XAFS実験ステーション利用の手引き

2001年7月

物質構造科学研究所 放射光研究施設

野村 昌治

まえがき

本書はこれまでに出版した BL-10B 関係、BL-6B、7C 関係利用の手引(下記)の統合改訂版 である。この間、BL-6B の閉鎖、BL-12C、9A の建設等に伴い光学系、検出系、制御ソフト等 において多くの変化があり、また旧版も絶版となったことから新たに編集した。XAFS 実験の普 及に伴い、ともすれば cooking book に対する要望が強くなり勝ちであるが、信頼しうる実験結 果を得るためにはビームライン光学系、検出系や制御系に対するある程度の理解も必要であり、 他にその様なことを学ぶ機会も少ないため、これらの点に重きを置いて書いたつもりである。 XAFS 以外の実験をする方もモノクロメーター、ミラーを中心とする部分については理解してお く必要がある。

BL-10B が「誰にでも出来る XAFS」的な性格を持ち、高エネルギー分解能であったのに対し て、それ以外のステーションは BL-10B 程高いエネルギー分解能は得られないが、「主に BL-10B で出来なかった実験を BL-10B に飽き足らない研究者が行う」という位置づけで考えている。 従って、各ラインとも強度、ビームサイズ、測定エネルギー範囲等で特徴を持っている。また、 この間、SPring-8 でもいくつかの XAFS 実験を出来るビームラインが共同利用を開始している し、そのほか分子研の UV-SOR、立命館大学の Rits 等でも共同利用が行われている。これら他 施設のビームラインを含め、その長所を生かしながらレベルの高い研究を行って頂くことを期待 する。

本書は全体を二部構成とし、第1部 放射光利用実験編は主にPFでの実験ステーションの構成、利用手引的な性格を、第2部 XAFS 実験編 は汎用的に XAFS 実験手引き書的な性格を持た せたつもりである。従って第2部は他の放射光施設、実験室における実験にも有用であることを 期待する。また、本書は主に PFで XAFS 実験を行おうという相当レベルの研究・実験経験のあ る研究者、大学院生を対象と想定している。従って、ボンベの取扱法等の基本実験技術について は別の書籍を参照して頂きたい。また、工作室の利用等の PF 全体に関することは、利用の手引 きまたは該当する web site を参照されたい。

実験で得た know-how は各実験グループにとって貴重なものであろうが、利用記録や log book、 メーリングリスト xsjを通して他のグループにも広めるだけの広い心を持って実験して頂きたい。 国内の研究者が協力してお互いの研究レベルを上げないと海外との競争に勝つことは出来ない。 XAFS 実験から良い結果・報告の出ることを期待している。

なお本書の内容は原則的に BL-7C、9A、10B、12C の全ステーションに適用される。ステーションは常に改良されているので、最新の情報は log book、PF-XAFS ホームページを見て頂きたい。

末筆ではあるが、本書の内容について貴重なアドバイスを頂いた渡辺巌(大阪大理)、朝倉清 高(北海道大触媒セ)、柳瀬悦也(川崎重工業㈱)技術研究所)の各氏に感謝する。

野村昌治、小山篤、「PF-EXAFS 実験の手引」PF 懇談会講習会資料(1985). 野村昌治、「BL-7C 利用の手引」KEK Internal 87-1 (1987). 宇佐美徳子、小山篤、野村昌治、「PF-XAFS 実験の手引(BL10B 用)」PF 懇談会(1991). 野村昌治、小山篤、「BL6B、7C 利用の手引き」 KEK Internal 93-1 (1993).

放射光研究施設 野村昌治

masaharu.nomura@kek.jp

本書の読み方

本書は BL-7C、9A、10B、12C を利用して実験する場合を想定して記してある。殆どの事項は この四ステーションに共通しているが、一部、ステーションによって異なることがある。特定の 実験ステーションにのみ適用される項目については [BL-10B]の様に示すか、本文中では BL-7C の様に太字で記してある。

参考文献は[]内に番号を記した。これらの文献の他に 1.7 節にビームライン関係の文献をまと めた。

第1部 放射光利用実験編	.9
第0節 XAFS 実験ステーション利用に当たってのルール	11
第1節 ビームラインの概要	13
1.1 XAFS 実験用ビームラインの概要1	13
1.2 ブランチビームラインの構成1	14
1.3 モノクロメーター1	15
1.4 ミラー	15
1.5 X線強度と純度1	16
1.6 データ採取と解析1	16
1.7 設計、性能評価レポート等 1	17
第2節 申請から実験終了まで	19
2.1 利用申請	19
2.2 審査からビームタイム配分まで	20
2.2.1 国内の大学等の研究者の場合	20
2.2.2 国外の大学等の研究者の場合	20
2.2.3 企業等の研究者の場合	21
2.3 準備すべき物品	21
2.4 来所まで	22
2.5 放射光研究施設で	23
2.6 実験終了後	24
	24
弟 3 節 放射線防護・安全	25
3.1 インターロックシステム	25
3.2 ハッナ庫の開閉	25
3.2.1 八ッチ庫を開ける	25
3.2.2 八ッナ庫を閉のる	26
3.2.3 版八庫を開闭9る	20
3.3 ヒームンヤッターの用闭	20 00
3.3.1 MBS を用ける	20
3.3.2 BBS、DSS を用ける	21
3.3.3 BBS、DSS を闭しる	21 97
3.4 ての他成別級女王	51 97
3.5 ℃の他の女王国际事項	21 97
3.5.1 文主主版	~1 28
3.5.2 电X文主	~0 28
3.5.5 10于女主	~0 20
5.5.4 冬月	~J 29
第4節 モノクロメーター (30
4.1 モノクロ前スリットの調整	30

	4.	2)	XX	泉光 学	学の基礎	. 31
	4.	3	_	_ź	結晶Ŧ	モノクロメーター	. 32
	4.	4	Ę	F -	ャンオ	ネルカットモノクロメーター	. 32
	4.	5	_	_ ź	結晶Ŧ	モノクロメーターの構造	. 33
	4.	6	S	ag	gittal	l focusing	. 34
	4.	7	伟	训	卸系.	~	. 35
		4	.7.	1	パルス	スモーターコントローラー(ツジ電子 PM4C-05)	. 36
		4	.7.	2	パルス	スモーターコントローラー(ツジ電子 IPM2C-01)	. 36
		4	.7.	3	ロータ	タリーエンコーダー(Heidenhain ROD800+VRZ460/ND261)	. 37
		4	.7.	4	DC E	E-タ-コントロ-ラ-(ツジ電子 DM3C-01)	. 37
		4	.7.	5	ピエン	ゾ素子用電源	. 37
	4.	8	訁	周昇	整法.		. 38
		4	.8.	1	回折像	像の確認	. 38
		4	.8.	2	非収束	束光学系	. 38
		4	.8.	3 s	sagitta	tal 収束光学系	. 39
		4	.8.	4 s	sagitta	tal 収束光学系を用いた測定例	. 40
第	5	節	ī	Ξ	ラー		. 41
	5.	1	-	Ξ	ラ −0	の必要性	. 41
	5.	2	Ē	品 見	界角.		. 42
	5.	3	复	ŧ,	光ミラ	ラー	. 43
	5.	4	Ē	高之	欠光险	除去用ミラー	. 44
		5	.4.	11	BL-7C	C の高次光除去用ミラー (focusing double mirror)	. 44
		5	.4.	21	BL-9A	A の高次光除去用ミラー	. 46
	5.	5	-	Ξ	ラ −0	の制御系	. 47
		5	.5.	1]	BL-7C	C の高次光除去用ミラー制御系	. 47
		5	.5.	28	8CH オ	ポジションモニター (ツジ電子 8PMON-01)	. 48
		5	.5.	3 1	16CH	Iパルスモーターコントローラー (ツジ電子 PM16C-02)	. 48
		5	.5.	4]	BL-7C	C の高次光除去用ミラーの調整	. 49
		5	.5.	51	BL-9A	A の高次光除去用ミラーの制御系	. 51
		5	.5.	61	BL-9A	A の高次光除去用ミラーの調整	. 51
	5.	6	浿	則	定例.		. 52
第	6	節	i	各	ピー	- ムラインの構成	. 54
	6.	1	E	BL	-10B	8	. 54
	6.	2	E	BL	-7C.		. 55
	6.	3	E	BL	-12C	2	. 56
	6.	4	E	BL	-9A.		. 58
第	7	節	i	X.	AFS	実験	. 60
	7.	1	言	+;	則系.		. 60
	7.	2		Ē	雛箱.		. 60
		7	.2.	1	電離箱	箱の構造と動作原理	. 60
		7	.2.	2	電離箱	箱に印加する電場について	. 62
	7.	3	치	Ę	置の起	起動	. 62
	7.	4	浿	則	定条件	件の設定	. 63
		7	.4.	1]	[。前ス	スリットの調節	. 63

7.4.3 試料の取り付け	66 67 99 99 70 71 73 74 75 75
7.4.4 電流増幅器の設定 9 第8節制御用マイクロコンピュータ 6 8.1 計算機の仕様 6 8.2 周辺機器についての注意 6 8.2.1 フロッピーディスクドライブ 8 8.2.1 クロッピーディスクドライブ 8 8.2.3 レーザーブリンター 8.3 ソフトの概要 8.4 OS に関する知識 7 9.5 XAFS 測定用ソフトウェアの利用 7 9.1 一般的な注意事項 7 9.2 動作環境の設定 7 9.2.1 データ保存ドライブの設定 7 9.2.2 スケーラーの還定 7 9.2.3 ユーザーPC との通信制御 9 9.2.4 電子/陽電子のエネルギー 9 9.2.5 設定の終了 9 9.4 XAFS 測定用ソフトの構成 7 9.4 XAFS 測定用ソフトの構成 7 9.4 XAFS 測定用ソフトの構成 7 9.4 XAFS 測定用ソフトの構成 7 9.5 メインルーチン 7 9.6 検出系の設定 1数確認 9.5 メインルーチン 7 9.6 検出系の設定 1数確認 9.6.1 検出系の設定 9 9.6.2 計数の確認 7 9.7 準備用サブルーチン 8 9.8 測定条件設定サブルーチン 8	67 59 59 59 59 70 71 73 74 75 75
第8節 制御用マイクロコンピュータ 6 8.1 計算機の仕様	59 59 59 70 70 71 73 74 75 75
8.1 計算機の仕様	59 59 70 70 71 73 74 74 75 75
8.2 周辺機器についての注意 6 8.2.1 フロッピーディスクドライブ 8 8.2.2 MO ディスクドライブ 8 8.2.3 レーザープリンター 8 8.4 OS に関する知識 7 第9節 XAFS 測定用ソフトウェアの利用 7 9.1 一般的な注意事項 7 9.2 動作環境の設定 7 9.2.1 データ保存ドライブの設定 7 9.2.3 ユーザーアとの通信制御 9 9.2.4 電子/陽電子のエネルギー 9 9.3 データの読み書き 7 9.4 XAFS 測定用ソフトの構成 7 9.3 データの読み書き 7 9.4 XAFS 測定用ソフトの構成 7 9.5 メインルーチン 7 9.6 検出系の設定 7 9.6.1 検出系の設定 7 9.6.2 計数の確認 7 9.7 準備用サブルーチン 8 9.8 測定条件設定サブルーチン 8	59 70 70 71 73 74 74 75 75
8.2.1 フロッピーディスクドライブ	69 70 71 71 73 73 74 75 75
8.2.2 MO ディスクドライブ 8.2.3 レーザーブリンター 8.3 ソフトの概要 7 8.4 OS に関する知識 7 第9節 XAFS 測定用ソフトウェアの利用. 7 9.1 一般的な注意事項 7 9.2 動作環境の設定 7 9.2.1 データ保存ドライブの設定 7 9.2.2 スケーラーの選定 9 9.2.3 ユーザーPC との通信制御 9 9.2.4 電子 / 陽電子のエネルギー 9 9.3 データの読み書き 7 9.4 XAFS 測定用 ソフトの構成 7 9.5 メインルーチン 7 9.6 検出系の設定 7 9.6.1 検出系の設定 9 9.6.3 検出系の設定・確認の終了 7 9.7 準備用 サブルーチン 8 9.8 測定条件設定サブルーチン 8	70 70 71 71 73 73 74 75 75
8.2.3 レーザープリンター	70 '1 ' 3 '4 74 75
8.3 ソフトの概要	71 73 74 75 75
8.4 OS に関する知識 7 第9節 XAFS 測定用ソフトウェアの利用	71 73 74 75 75
第9節 XAFS 測定用ソフトウェアの利用	'3 '4 74 75 75
9.1 一般的な注意事項	73 74 75 75
9.2 動作環境の設定 7 9.2.1 データ保存ドライブの設定 7 9.2.2 スケーラーの選定 9 9.2.3 ユーザー PC との通信制御 9 9.2.4 電子 / 陽電子のエネルギー 9 9.2.5 設定の終了 9 9.3 データの読み書き 7 9.4 XAFS 測定用ソフトの構成 7 9.4.1 Novice mode の初期処理 9 9.4.2 Expert mode の初期処理 9 9.5 メインルーチン 7 9.6 検出系の設定・計数確認 7 9.6.1 検出系の設定 7 9.6.2 計数の確認 7 9.7 準備用サブルーチン 8 9.8 測定条件設定サブルーチン 8	74 74 75 75
9.2.1 データ保存ドライブの設定 9.2.2 スケーラーの選定 9.2.3 ユーザー PC との通信制御 9.2.4 電子 / 陽電子のエネルギー 9.2.5 設定の終了 9.3 データの読み書き 9.4 XAFS 測定用ソフトの構成 9.4.1 Novice mode の初期処理 9.4.2 Expert mode の初期処理 9.4.3 制約事項 9.5 メインルーチン 9.6 検出系の設定・計数確認 9.6.1 検出系の設定 9.7 準備用サブルーチン 9.8 測定条件設定サブルーチン	74 75 75
9.2.2 スケーラーの選定 9.2.3 ユーザー PC との通信制御 9.2.4 電子 / 陽電子のエネルギー 9.2.5 設定の終了 9.3 データの読み書き 7 9.4 XAFS 測定用ソフトの構成 7 9.4.1 Novice mode の初期処理 9 9.4.2 Expert mode の初期処理 9 9.5 メインルーチン 7 9.6 検出系の設定・計数確認 7 9.6.1 検出系の設定 9 9.6.3 検出系の設定・確認の終了 9 9.7 準備用サブルーチン 8 9.8 測定条件設定サブルーチン 8	75 75
9.2.3 ユーザー PC との通信制御	75
9.2.4 電子 / 陽電子のエネルギー 9.2.5 設定の終了 9.3 データの読み書き 7 9.4 XAFS 測定用ソフトの構成 7 9.4.1 Novice mode の初期処理 7 9.4.2 Expert mode の初期処理 9 9.4.3 制約事項 7 9.5 メインルーチン 7 9.6 検出系の設定・計数確認 7 9.6.1 検出系の設定 7 9.6.2 計数の確認 9 9.7 準備用サブルーチン 8 9.8 測定条件設定サブルーチン 8	
9.2.5 設定の終了	75
9.3 データの読み書き	76
9.4 XAFS 測定用ソフトの構成 7 9.4.1 Novice mode の初期処理 9 9.4.2 Expert mode の初期処理 9 9.4.3 制約事項 9 9.5 メインルーチン 7 9.6 検出系の設定・計数確認 7 9.6.1 検出系の設定 9 9.6.2 計数の確認 9 9.7 準備用サブルーチン 8 9.8 測定条件設定サブルーチン 8	' 6
9.4.1 Novice mode の初期処理 9.4.2 Expert mode の初期処理 9.4.2 Expert mode の初期処理 9.4.3 制約事項 9.4.3 制約事項 9.5 メインルーチン 9.5 メインルーチン 7 9.6 検出系の設定・計数確認 7 9.6.1 検出系の設定 9 9.6.2 計数の確認 9 9.6.3 検出系の設定・確認の終了 9 9.7 準備用サブルーチン 8 9.8 測定条件設定サブルーチン 8	'7
9.4.2 Expert mode の初期処理	78
9.4.3 制約事項	78
9.5 メインルーチン	78
9.6 検出系の設定・計数確認 7 9.6.1 検出系の設定 7 9.6.2 計数の確認 7 9.6.3 検出系の設定・確認の終了 7 9.7 準備用サブルーチン 8 9.8 測定条件設定サブルーチン 8	'8
9.6.1 検出系の設定 9.6.2 計数の確認 9.6.3 検出系の設定・確認の終了 9.7 準備用サブルーチン 8.8 測定条件設定サブルーチン	'9
9.6.2 計数の確認 9.6.3 検出系の設定・確認の終了 9.7 準備用サブルーチン	79
9.6.3 検出系の設定・確認の終了 9.7 準備用サブルーチン	30
9.7 準備用サブルーチン	31
9.8 測定条件設定サブルーチン	31
	32
9.9 測定用サブルーチン	37
9.10 測定中の測定条件の変更等)1
9.11 データ入出力サブルーチン)3
9.11.1 文字出力	J 3
9.11.2 グラフィックス出力	J 3
9.11.3 データ入力	94
9.12 データフォーマット)5
9.13 エラーメッセージ	8(
第 10 節 蛍光 XAFS 法10	0
10.1 蛍光検出法の原理	0
10.2 測定上の注意点)1
10.3 fluorescent ion chamber detector	-
10.4 シンチレーションカウンター)3

	10.5	半導体検出器1	106
	10.6	測定例1	107
第	11 節	周辺設備1	108
	11.1	電力、冷却水、圧搾空気、排気1	108
	11.2	クライオクーラー及び温度制御器1	109
	11.2	2.1 クライオクーラー	109
	11.2	2.2 温度制御器	110
	11.2	2.3 温度制御器	111
	11.2	2.4 真空漏れ探し等	112
	11.3	XAFS 測定用反応試料槽1	113
	11.4	電気炉1	113
	11.5	赤外線ゴールドイメージ炉1	114
	11.6	試料位置調整機構	114
	11.7	全反射実験用試料方位調整機構	114
	11.8	錠剤成形器 1	115
	11.9	ポリシーラー1	115
	11.10	真空ポンプ1	115
	11.1	10.1 アルカテル社製 T2012A	115
	11.1	10.2 真空機工製 G-20D	116
	11.11	ペンレコーダー1	116
	11.12	ディジタルマルチメーター	116
	11.13	ボラロイドフィルム現像機1	117
	11.14	小型ミラー	117
	11.15	マルチチャネルアナライザー	118
	11.16		118
第	12 節	トラブルシューティング1	119
	12.1	パソコン関係1	119
-	12.2	スペクトル関係	120
	12.3	周辺機器関係]	121
罞	13即	〕 参考又献	122
	_		
第	2 部	XAFS 実験編1	23
<i>/n/</i> r	. mm		
矛	1即	XAFS に関する主な解説	125
 , 第			127
2	2.1	転週は試科の厚と」 ↓ ほぼは 0月0	127
	2.1.	.1 透過法の場合	127
	.z.1	.4 虫元法の场合	128
2	2.Z 1	透迴法試科の厚さの昇급] ↓ 計算支法	129
	Z.Z.	.1 計昇力汰	129
	z.z. • • •	.4 JAMILLEM	130
2	ະ.ວ ≣ ວາ ≐	汎枠神調桜上の注息品	132
7	≎.4 ≣ ∩∕	迅ヘキᡃѴ]詞 桜 /広	130
	Z.4.	.1	136

	2.4	.4.2 液相試料	136
	2.4	.4.3 特殊条件下での測定	137
第3	節	│ 分光結晶の選択	138
第4	節	信頼出来るデータを得るために	
4	.1	XAFS 信号はどれくらい小さいか	141
4	.2	ブランクテスト	141
4	.3	簡単な性能テスト	141
4	.4	実験データの予備的な解析	142
4	.5	glitch	142
4	.6	thickness effect	143
第5	節	└ 吸収端・蛍光 X 線のエネルギー	
5	.1	吸収端のエネルギー	144
5	.2	蛍光 X 線のエネルギー	153
5	.3	蛍光 XAFS 用フィルターの例	154
第6	節	検出器用ガスの選択	156
6	.1 /	バックグラウンド吸収係数	156
6	.2 †	検出効率	156
第 7	節	参考文献	172

第1部

放射光利用実験編

第0節 XAFS実験ステーション利用に当たってのルール

XAFS 用実験ステーションは多くの研究者によって多くの研究目的に利用されている。大学や 企業の一研究室と異なり、関係する全ての研究者が顔を合わせて話し合う機会も限られており、 ある人が善意で行った事でも、他の人にはそうとられない事もある。このため、利用研究者も施 設側も努力して意志疎通を図る必要がある。特に初めて課題を申請し、XAFS 実験を行われる方 は申請前から担当者と密接に話し合われることをお勧めする。また、意志疎通を図る一つの方策 が各ステーションに備えられた log book であり、メーリングリスト xsj (2.7 節参照)であるので、 実験中は詳細な記録をとり、積極的な発言をする事をお願いする。

あなたが快適に実験をしたいのと同様、他の実験者も快適に実験を行いたいと思っている。是 非、以下のルールを守って、快適に実験をし、良い研究成果が出せるようご協力願う。

- PFで XAFS を担当する職員の数は限られており、学生を含めた全ての実験者の面倒を見る ことは現実的でない。ビームタイム、ステーションの状況に関する連絡は実験責任者または (海外からの申請の場合) contact person in Japan に送られるので、これらの方は責任をもっ て情報をメンバーに徹底すると共に必要な手続きを期限までに行なうことをお願いする。事 務手続き等の詳細については申請受理後連絡する。
- 事務手続き上、実験上の十分な準備をした上で来所すること。これは実験責任者及びメンバーの責任であり、手続き不備や忘れ物に対する処置はステーション担当者の職務ではない。 ただ、人間は万全の準備をしたつもりでも、忘れ物をしたりすることもある。その場合は遠慮なくご相談下さい。
- 3. 実験上の必要があって P F の物品を借用する場合は来所前早目に担当者に申し込むこと。以前にステーションにあったものでも他のステーションに貸し出されることもある。
- 4. ステーションとその付属装置は多くのユーザーの共有財産であるので大切に扱い、性能の維持、向上に務めること。万一トラブルを発見したり、破損した場合は log book に状況を詳細に記録すると共に速やかにステーション担当者に連絡すること(いつ、何をしたら、どうなった、対処はどうした)。障害の原因を解明するにも、メーカーに機器の修理を依頼する場合も担当者が詳細な状況を把握している必要がある。また、同じトラブルの再発を防ぐためにも原因を明らかにする必要がある。ケーブルのコネクタがとれた、クライオクーラー・電気炉の真空の洩れ探し等実験者で処置できるトラブルは自分で処理すること。但し、対処する自信の無いものについては被害を拡大する前に状況を保存し、ステーション担当者に連絡すること。装置の破損はステーションの閉鎖にも繋がるので充分に使用法に習熟して、注意して扱うこと。
- 5. モノクロメーター、スリット等の調整をした時は調整前後の情報を log book に記録すること。 この時、変更をした意図も記した方が後から役に立つ。
- 6. モノクロメーター、ミラー等ビームライン中に設置された装置の内部の調整はステーション 担当者立会いの下で行うことを原則とする。また、ユーザーはシャッター及びハッチ扉の開 閉以外のインターロックに関わる作業を行ってはならない。インターロック機器に異常があ る場合は運転当番に連絡すること。また、実験装置の搬出入等のために実験ハッチの搬入扉 を開ける必要がある場合は事前にステーション担当者と連絡を採ること。

- 7. 光学系の調整、高次光除去ミラーの利用、蛍光 XAFS 測定については十分信頼できる経験者 とチームを組んで行なうこと。一寸した不注意でこれらの機器を破損することがありえる。 また、破損した場合は修理に高額を必要とするだけでなく、長期間に亘って利用実験を行え なくなる恐れがある。
- 8. 最新の情報は log book 及び PF-XAFS ホームページ(2.7 節参照)に示される。来所前にホーム ページを確認すると共に、来所時には前回来所後の log book を読んでから実験を開始する事 を励行して頂きたい。
- 9. 機器が安定になるまでには数時間を要することがある。次の機器の電源を許可なく切って帰らないこと。 電流増幅器(2台)、V/F converter の入った NIM BIN、ロータリーエンコーダーのカウンター また、電流増幅器をオーバーフローさせると長時間にわたって offset が変化するで、注意す ること。

第1節 ビームラインの概要

1.1 XAFS実験用ビームラインの概要

PF(Photon Factory、放射光研究施設)の電子蓄積リングには 28 個の偏向電磁石があり、それらを区別するため番号が付けられている。そのn番目の偏向部から出る放射光を使うビームラインという意味で BL-n と呼ばれている。一部の 3GeV 運転を除き、 PFリングは 2.5GeV で運転されている。執筆時点で運動している荷電粒子は電子で、蓄積電流値が 1/e になるまでの時間(寿命)は数十時間で、1日1回の入射をして 450mA の蓄積を行っている。

硬X線領域の XAFS 実験用のステーションとしては BL-7C、9A、10B、12C が共同利用に供さ れている。この内、BL-10B は、PFの運転開始(1982 年)以来 XAFS 専用に使われており、四ス テーションの中では最も高エネルギー側の 6~33keV(K 端で Mn~Te)の範囲をカバーしてい る。高いエネルギー分解能を持って広いエネルギー範囲をカバーできる点、チャンネルカット結 晶を用いているため比較的簡単に利用出来る点に特徴を有する。電子蓄積リングの臨界エネルギ ーの関係から、25keV 程度以上のエネルギー域での実験には 3GeV 運転の利用を推奨する。BL-10 にはこの他に垂直型四軸回折計を備えた BL-10A、小角散乱実験用の BL-10C のニステーショ ンがある。

BL-7 は東京大学理学部付属分光化学センター(当時:現スペクトル化学研究センター)とP Fが共同で建設し、1986 年から利用されている。分光化学センターが 7A、7B のブランチライ ンの建設を行い、7C はPFが建設した。BL-7C はサジタル集光型二結晶分光器と高次光除去用 の二枚組ミラーを備えたことに特徴があり、主に 4~21keV(K 端で Ca~Mo)域の実験に利用出来

	備考	BL-10B	BL-7C	BL-12C	BL-9A
ハードウェア エ ネ ル ギ ー 範 囲	Si(111)	(6 ~ 17keV)	4 ~ 21keV	5 ~ 20keV	2.2 ~ 15keV
	Si(311)	6~33 keV	(6 ~ 34keV)	(6 ~ 34keV)	none
モノクロメーター		channel-cut	二結晶	二結晶	二結晶
出射ビーム方向		一定	一定	一定	一定
向 出射ビーム高 エネルギー分	通常の条	変化する	一定	一定	一定
解能 エンコーダー	件で	なし	0.0001 ゜読み	0.0001 。読み	0.0001 [°] 読み
集光機能		なし	分光結晶によ る一次元集光 sagittal focus	弯曲円筒ミラ ーによる二次 元集光	二枚の弯曲円 錐台ミラーに よる二次元集 光
強度					
取り扱いの容 易さ		容易	推ササ	比較的容易	比較的容易
実験の自由度	İ	小	大	中	中

表 1.1.1 XAFS 用実験ステーションの比較。詳細は本文及び第6節参照のこと。

る。集光することによって光子束が増し、蛍光 XAFS 実験が可能となっている。XAFS 以外の発 光・散乱実験等も行われている。BL-7A は 2000 年秋に VLSG(Varied Line Space Grating)を用い、 100~1500eV 領域の XAFS 実験も行えるビームラインとして再登場した。BL-7B は中二階にあり 瀬谷・波岡型の回折格子分光器を備えており 50eV 以下の単色の真空紫外光を使える。

1987 年には BL-6B が建設された。ここではサジタル集光型二結晶分光器を備え、ニーズの高かった BL-7C の補完用として機能したが、1995 年に XAFS 実験用ステーションとしての使命を 終え、タンパク質構造解析用の実験ステーションとして再構築された。

BL-12C は 1994 年に建設したビームラインで、二結晶分光器で分光後、弯曲円筒ミラーで集 光を行う光学系を採用した。エネルギーに依らず小さなフォーカスを得られることとステーショ ンに備えられた多素子半導体検出器を用いた蛍光 XAFS 法に特徴がある。主に 5~20keV(K 端 で V~Nb)域の実験に適している。BL-12A は軟X線・真空紫外線領域の光学素子評価用ビーム ラインであり、BL-12B は高分解能極紫外垂直分散型分光器が備えられ、5~30eV 域での高分解 能実験に供されている。

BL-7C 以上の強度と BL-12C 並のフォーカス、使い勝手を目指して 1999 年までに建設された のが BL-9A である。主に 2.2~15keV(K 端で P~Kr)域の実験に適している。BL-9 は日本電気 ㈱によって建設されたビームラインで、BL-9B では光化学反応実験が、BL-9C では六軸回折計 等を用いた回折実験等が行われていたが、2000 年にPFへ寄贈され、BL-9B は閉鎖された。BL-9C はその後、小角散乱実験も行えるように改造が施された。

各ビームラインの詳細は第6節に記す。

1.2 ブランチビームラインの構成

BL-7C ブランチビームラインの構成を図 1.2.1 に示す。他のラインでも基本は同じである。電 子蓄積リングの中は 10⁻¹⁰ Torr より良い真空状態にあり、一方実験は通常大気中で行われるので その間は何枚かの窓で仕切られている。上流から見ると先ず 2 枚のベリリウム窓(各々厚さ 0.2mm)によってリングの超高真空と仕切られている。この二枚(9A では 0.1mm が一枚)の 窓の間は 10⁻⁹ Torr 程度に排気されている。これより下流側は 10⁻² Torr 程度の低真空雰囲気であ り主な光学素子はこの中に設置されている。最後に再びベリリウム窓(0.2mm)と Kapton 窓



(0.03mm) があり、その間はヘリウムで満たされてい る。このベリリウム窓を破るとビームラインに大気が 流入して実験出来なくなる。条件が悪いと上流のベリ リウム窓も衝撃波で破損する恐れもあるので注意が必 要である。安全のためビームラインの真空が悪くなっ たり、冷却水流量が減少したり、ヘリウムの流量が低 下するとシャッターや真空バルブが閉じる。この様 な事が起こった時は運転当番またはステーション担 当者に速やかに連絡すること。

電子蓄積リングと実験ステーションの間には3つの シャッターが設置されている。主ビームシャッター (MBS)はリニアック(linac)からリングへ電子を 入射している間は閉じられ、実験者が 線によって被 曝することを防いでいる。当該メインビームラインに 属する全てのブランチビームラインを使用停止状態 (インターロックの鍵を STOP 側に回した状態)にし た時以外、実験者が MBS を閉じることは出来ない。 ブランチビームシャッター(BBS)は各ブランチビー



図 1.2.2 BL-10B の様子。奥に実験ハッチ、 その手前右に制御用ラック、左にモノクロ メーターが見える。

ムラインが独立に実験を行えるように設けられている。この他に試料交換等のためにハッチ内に入っている間にモノクロメーター結晶の温度が変化することを防ぐため下流シャッター(DSS または SHUTTER)が設けられている。10分程度以上 DSS を閉じていると BBS も自動的に閉められる。

実験中に被曝することのないように実験はハッチ(hutch)と呼ばれる小屋の中で行われ、シャッターを開けている時はハッチの中へ入ることは出来ない。放射線安全及びインターロックシステムの取扱いについては第3節を参照のこと。

リングから出てきた放射光はモノクロメーター直前にある四象限スリットによって整形される。 このスリットはビーム高さのモニターとしても機能している。通常は実験者がこのスリットを操 作する必要は無い(4.1節参照)。

1.3 モノクロメーター

モノクロメーター(monochromator)は白色の放射光の中から実験に必要なエネルギーのX線を 取り出すために用いられる。X線領域ではシリコン結晶が主に利用され、BL-10B では Si(311)チ ャンネルカット分光器、BL-7C、12C、9A では Si(111)二結晶分光器が通常用いられている。ビ ームタイムに対する需要、運転モードとの整合性を見て、分光結晶を交換することもある。二結 晶分光器は分光と同時に高次光の割合を抑制する。BL-7C の分光器は第二結晶を弯曲させるこ とによって分光と同時に水平方向に発散した放射光を集光する役割も果たしている。詳細は第4 節を参照のこと。

1.4 ミラー

ミラー(mirror)には大別して二つの役割がある。一つは集光機能であり、BL-12C、9Aでは水平、 鉛直両方向に発散した放射光を集光する役割を果たしている。また BL-7C でも必要に応じて鉛 直方向に発散した放射光を集光出来る。 もう一つの役割はモノクロメーターから出てくる高次の回折 X 線(高次光)を除くことである。 特に低エネルギー域における XAFS 実験では高次光を除くことが重要であり、この目的のため BL-7C には focusing double mirror が設置されている。また、BL-9A には同様に二枚組の平板ミラ ーがあり、この目的に利用出来る。高次光除去用のミラーが設置されていないビームラインでは ハッチ内に小型の平板ミラー(10.14 参照)を持ち込んで同様の機能を果たすこともある。詳細は 第5節を参照のこと。

1.5 X線強度と純度

2.5GeV 300mA 運転時に BL-7C で、1mm(V) × 6mm(H)の出口スリットを通過してくるX線の 光子数、高次光の割合を電離箱の出力電流から求めた結果を表 1.5.1 に示す。集光をすることに よって一桁以上の強度の増大が得られることが分かる。また高エネルギー域ではデチューニング (detuning、4.2 節参照)によって、低エネルギー域でもミラーを使用することによって十分に純度 の高い単色光を得ることが出来る。

また、図 1.5.1 に XAFS 実験用の各ビームラインで得られる X 線強度を X 線エネルギーの関数 として示した。ここに示されるように、一般的に良く使われる 10keV 付近では強度的には 9A > 7C > 12C > 10B となっている。また、ビームラインの光学系に依って得られる X 線強度が大きく 異なることが分かる。但し、通常の XAFS 実験でこの強度の差がデータの質を決めることは稀 である。詳細は第二部で触れる。

1.6 データ採取と解析

一般の XAFS 実験用のハードウェア及びソフトウェアはステーションに設置されている(第7節以降参照)。ソフトウェア、データフォーマットは基本的に四ステーションとも共通である。 各ステーションにはネットワークに接続されたパソコンがある。このパソコンには Microsoft Office、Internet Explorer等の事務処理ソフトの他に理学電機株式会社のご厚意により同社製 XAFS

a) photon flux]	higher order		
	1	-	w/o. m	irror	w. mirror
<i>E</i> /keV	w/o. focus	w. focus ^{b)}	max. tune	60% tune	max. tune
4	1×10 ⁹	2×10 ¹⁰ (14)		4×10^{-2}	3×10 ⁻⁵
5	4×10 ⁹	6×10 ¹⁰ (15)	1×10^{-1}	2×10^{-3}	6×10 ⁻⁵
6	7×10 ⁹	1×10 ¹¹ (14)	4×10^{-2}	2×10^{-4}	3×10 ⁻⁶
7	8×10 ⁹	1×10 ¹¹ (15)	7×10^{-3}	4×10^{-5}	
8	9×10 ⁹	$1 \times 10^{11}(14)$	4×10 ⁻⁴	5×10^{-6}	
9	8×10 ⁹	$1 \times 10^{11}(13)$	4×10^{-4}	5×10^{-6}	
11	7×10 ⁹	7×10 ¹⁰ (10)	5×10 ⁻⁴	7×10^{-6}	
13	6×10 ⁹	2×10 ¹⁰ <4>	1×10 ⁻⁴	3×10^{-5}	
15	4×10 ⁹	1×10 ¹⁰ <2>			
17	3×10^{9}				

表 1.5.1 BL-7C で測定した光子束及び高次光の割合

a) Photon flux passed through a $1 \times 6 \text{ mm}^2$ slit at 300 mA storage.

b) Values in () and \ll mean the gain by focusing. The latter was measured under the focusing condition for E = 11 keV.

c) When the mirror was used, θ was chosen as $I_0(w. mirror)/I_0(w/o. mirror)$ becomes ~0.5 at $E' = E_{edee} + 1$ keV.



られる光子束。 2.5GeV 400mA 運転時に規格化して ある。但し BL-10B で 3GeV 運転時のデータは実態に合 わせて 200mA 蓄積時のデー タとしてある。

3GeV 運転は高エネルギー 域において効果が大きい。 格子面の右側の数字はス リットサイズ (単位 mm)。

|解析ソフト Rex (MS-DOS 版)及び Rex2000(windows 版)がインストールしてある。このためデ ータ転送や予備的なデータ解析、事務処理等に利用出来る。この他、実験ホール内に配置された ネットワークに接続されたパソコンを用いてデータ転送や事務処理を行うことが可能である。

設計、性能評価レポート等 1.7

XAFS 関係ビームラインの性能評価等に関して以下のレポート類を出している。ビームライン を利用した成果として報文を出版される場合は当該ラインに関するレポートを引用して頂くよう お願いする。なお、これらの内 KEK Report、KEK Internal は高エネルギー加速器研究機構のホー ムページから post Script ファイルをダウンロードすることも出来る(PFXAFS の web サイト (http://pfwww.kek.jp/nomura/pfxafs/)からリンクを張ってある)。

[BL-10B 関係]

- H. Oyanagi, T. Matsushita, M. Ito and H. Kuroda, "An EXAFS Spectrometer on Beam Line 10B at the Photon Factory", KEK Report 83-30 (1984).
- M. Nomura, "Performance of the EXAFS Beam Line at Photon Factory", KEK Report 85-7 (1985).
- M. Nomura and A. Koyama, "Performance of BL10B and a simple performance test for EXAFS stations", KEK Report 89-16 (1989).

[BL-7C、6B 関係]

M. Nomura, A. Koyama and M. Sakurai, "Design and performance of beamline 7C at the Photon Factory", *KEK Report* **91-1** (1991).

[BL-10B、7C、6B 関係]

M. Nomura and A. Koyama, "Performance of EXAFS stations at Photon Factory", in "X-ray Absorption Fine Structure," ed. by S. S. Hasnain, Ellis Horwood, London (1991), pp.667.

[BL-12C 関係]

- M. Nomura and A. Koyama, "Design and performance of a new XAFS beamline at the Photon Factory; BL- 12C", *KEK Report* **95-15** (1996).
- M. Nomura, "Dead-time correction of a multi-element SSD for fluorescent XAFS", *J. Synchrotron Rad.*, **5**, 851 (1998).
- M. Nomura, "Design and performance of a multi-element SSD for fluorescent XAFS", *KEK Report* **98-4** (1998).

[BL-9A 関係]

Nomura, M., Koyama, A., "Design of an XAFS beamline at the Photon Factory: possibilities of bent conical mirrors", *J. Synchrotron Rad.*, **6**, 182 (1999).

Nomura, M. and Koyama, A., "Performance of a beamline with a pair of bent conical mirrors", *Nucl. Instrum. and Methods*, A, in press.

第2節 申請から実験終了まで

2.1 利用申請

放射光研究施設の利用には大別して、二つのカテゴリーがある。一つは共同利用実験(G型) [1]であり、もう一つは施設利用である。これらの性格は前者が大学等の研究者を主たる対象と して無料であるのに対し、後者は主に企業等の研究者を対象として有料で行われる。共同利用の 場合は年二回(11、5月の第一金曜)の申請締切があり後述するような審査を経て実施に至るが、 施設利用の申請は随時受け付けている。このほかに民間等との共同研究というカテゴリーで企 業等とPFが共同研究を行うケースも多い。民間等との共同研究は随時開始出来る。

共同利用でも特に緊急性を有する重要課題(**U型**)については随時申請書を提出することが出 来る。この申請が採択された場合は既に配分したビームタイムを振り替えて実施されることもあ る。

初心者及び予備実験用にはP型申請がある。これは、初心者の場合、実験技術、申請書の書き 方等の点でベテランと同列に評価をすることが適当では無いために設けられたカテゴリーである。 スムーズに研究を進めるためにも申請前早目にステーション担当者と技術的な相談^{*}をした上で、 申請書を提出することが求められる。また、相当な経験がある研究者でも実験の成否の可能性 を予測出来ない場合の予備実験も含まれる。

大型の装置開発やビームライン建設を伴う S型というカテゴリーもあるが、詳細は応募資料等 を参照されたい。

申請に当たっては所定の事項以外に特に以下の事を明記して頂きたい。

- 当該ステーションでの測定可能性。申請書を読んで「はたして測定できるかな」と疑問に思うことが時々ある。定量的に検討した上で測定可能であると判断した場合はその判断の根拠 を簡単に書き添えた方が良い。
- 2.XAFS 実験は研究全体の一部を構成していることは稀でない。この場合、研究全体の統括責任者ではなく、XAFS 実験の全体を把握している人が実験責任者となることが望まれる。現場でビームライン担当者との対応を行うことが出来ない実験責任者ではとっさの場合の連絡が困難になる。また実際にその研究に参加しない方を実験組織に加えないこと。
- 3.必要となるビームタイムの算出根拠を簡単に記すこと。不必要に長いビームタイムは計画が 煮詰まっていないと思われる。透過法 XAFS 実験の場合は試料の組成にもよるが1スペクト ル当たり 20~30 分で計算して充分と考えられる。
- 4.XAFS 実験の場合は関連するステーションを一群にしてビームタイム配分を考えるので特に 希望のステーションがある場合は理由を明記すること。現在は原則として以下のようにステ ーションを決定している。
 - ・7keV 程度以下の低エネルギー域での実験は BL-9A または BL-7C。
 - ・高エネルギー域での XAFS 実験は BL-10B。
 - ・ 6~20keV 域の蛍光 XAFS で BL-7C では困難なものは BL-12C。
 - ・ XAFS 以外の実験は原則として BL-7C。

^{*} ここで求めている相談は学問的、技術的な打ち合わせである。

2.2 審査からビームタイム配分まで

2.2.1 国内の大学等の研究者の場合

共同利用申請については先ず実験ステーション担当者が申請書を読み「予備審査のための参考 意見」を所定の形式に従ってまとめる。この後一課題につき3人の評定者が学問、技術、組織、 総合の各項目について評価する。この予備審査の結果を基にして放射光共同利用実験審査委員会 (Photon Factory Program Advisory Committee, PF-PAC)の実験課題審査部会で審査を行なった後、 PF-PAC、物質構造科学研究所運営協議会の議を経て所長が採否を決定する。この際、採択、条 件付き採択、保留、不採択に分けられる。採択、条件付き採択については評点が付けられる(数 字の大きい方が高い評価である)。条件付採択については指摘事項に回答し PF-PAC 委員長が採 択適当と認めた場合、保留については更に運営協議会が認めた場合に採択手続きが進められる。 採択された課題に対しては審査結果通知が実験責任者に送られる。

これらと平行してステーション担当者より、ステーション利用に関する説明書 (「PF-XAFS ス テーション利用に当たって」)、実験計画書提出期限の案内を送付するので良く読み、必要な行動 をとること。

実際にビームタイムの配分を得るためには、ビームタイムを必要とする期毎に実験計画書を提出する。提出時期については各実験責任者宛連絡をすると共に PF-XAFS ホームページ(2.7 節参照)に示す。実験計画書を期限までに返送した課題に対してステーション担当者がビームタイム配分の原案を作成し、PF内でのミーティングを経た上で、ビームタイム配分委員会で決定する。 配分に当たっては PF-PAC による評価が尊重される。「実験計画書」の用紙はホームページから ダウンロード出来る。

各期のビームタイムはユーザータイムが始まる約 1.5 ヶ月前に各実験課題の責任者へ連絡する 予定である。この連絡は責任者宛に発送するので、責任者は各グループのメンバーに責任をもっ て伝えること。特に責任者が長期出張をする場合は適切な対処をすること。課題採択から実施ま での間に、これらと平行して各種事務手続きを遅滞無く行なうこと。

2.2.2 国外の大学等の研究者の場合

国外の場合も Contact Person in Japan (以下 CPJ)を必要とする点を除き基本的には国内の場合と同様である。CPJ には以下のような役割を果たすことを期待している。

- 高エネルギー加速器研究機構と実験責任者間の事務連絡。受理通知をはじめ事務的な書類等 はすべて CPJ 宛送付される。出来るだけ英文化するよう務めてはいるが、必要に応じ翻訳 の上、実験責任者へ連絡することをお願いする。また国によっては放射線安全、化学安全等 のルールが日本とは異なる場合もあるので適宜説明を加えることをお願いする。
- 来日のために必要な便宜供与またはそのための連絡。機構宿舎宿泊依頼の仲介、来所方法の 指導等。国に依ってはビザ取得のために必要な証明書類発行の援助。
- 実験支援または適当な支援者の斡旋。実験そのものの他に生活支援も含まれる。即ち、海外からの利用者であっても国内の利用者同様に実験を出来る状況を(担当スタッフの負担の増大無しに)作ることが求められる。従って、共同研究者として申請の前段階から研究、生活全般の面倒を実質的に見られる方が最も望ましい。
- 国によっては課題申請書の書き方が PF での基準と合致しないことがある。そのまま申請して、不採択となると先方を落胆させるので、予め申請内容、申請書の書き方をブラシュアップされることを期待する。

日本の研究者が ESRF や APS 等の海外の施設を使うのと同様に、PF も海外の研究者に窓口

を開いている。しかしながら、これらの施設と比較して、PF はビームラインの数が多い反面、 スタッフ数が少なく、事務系職員も必ずしも英語に堪能ではない。海外の研究者から PF に照会 があった時は、研究分野が近いと考えられる数名の方を先方に紹介し、先方からそれらの方に接 触して頂く。XAFS に関係するコミュニティメンバーの責任としてこれらの海外からの研究者が 快適に実験を行えるように CPJ を引き受けて頂くことを期待する。しかし、CPJ に掛かる負担は 決して軽くは無いので、責務を全う出来ないと予想される場合は引き受けない事を勧める。名前 さえ貸せば良いという気持ちで引き受けると、先方にも PF にも負担とストレスを掛け、悪印象 を残すことになる。

事務手続きは国内の研究者の場合と同様に行われる。相違点は、全ての手続きが CPJ を経由 して行われることである。

2.2.3 企業等の研究者の場合

施設利用申請の場合はステーション担当者による参考意見、評定者に依る評価、PF-PAC による審査はなく、物質構造科学研究所運営協議会で採択され、審査結果が申請者に送られる。民間 等との共同研究については機構の主幹会議で承認され、契約書が締結される。これらと平行してステーション担当者よりステーション利用に関する説明書(「PF-XAFS ステーション利用に当たって」)、実験計画書提出期限の案内を送付するので良く読み必要な行動をとること。

実際にビームタイムの配分を得るためには、ビームタイムを必要とする期毎に実験計画書を提 出する。提出時期については各実験責任者^{*}宛連絡をすると共に PF-XAFS ホームページに示す。 実験計画書を期限までに返送した課題に対してステーション担当者がビームタイム配分の原案を 作成し、PF 内でのミーティングを経た上で、ビームタイム配分委員会で決定する。「実験計画 書」の用紙はホームページからダウンロード出来る。

各期のビームタイムはユーザータイムが始まる約 1.5 ヶ月前に各実験課題の責任者へ連絡する 予定である。この連絡は責任者宛に発送するので、責任者は各グループのメンバーに責任をもっ て伝えること。特に責任者が長期出張をする場合は適切な対処をすること。課題採択から実施ま での間に、これらと平行して各種事務手続きを遅滞無く行なうこと。

2.3 準備すべき物品

ここでは実験に必要と思われる物品について記す。消耗品は原則として各実験者が用意すること。

1. 個人被曝線量計、印鑑(出張手続の時)

PF で実験をする人は所属機関で放射線業務従事者として登録され、PF で放射線作業に従事す ることを所属機関の放射線管理責任者から承認される必要がある。個人被曝線量計を忘れると 実験ホールに立ち入れなくなる。

2.リナグラフ

光軸調整に用いる。感度は低いがX線のイメージをその場で観測できる。

Kodak Linagraph Direct Print type 2167 か 1895 (Kodak 社代理店で入手できる)

@10000 円位 (6"×100ft)

本来の用途は電磁オシログラフ用の記録紙であるので入手が困難になってきている様である。 またマススペクトル用記録紙も同様に利用できるものがある。

^{*} 事務手続き上、施設利用の場合は研究所長等が申請者となることが多いが、実務的な連絡は実際上 の責任者と取らせていただく。

オリエンタルオシログラフペーパー 紫外線型 type NC C-155

(情報提供:北見工大 高橋 信夫氏)

3.ポラロイドフィルム

光軸調整、試料位置、試料の均一性のチェックに用いる。
Polaroid Polapan 4×5 Land film
タイプ57 (ASA 3000) 一箱 20 枚入
タイプ52 (ASA 400) 一箱 20 枚入
タイプ54 (ASA 100) 一箱 20 枚入
いずれも写真屋等で入手できる(一箱8000円位)。
光軸調整には54の方が、回折パターン等を撮る場合は57の方が便利。以上のフィルムの
現像機は用意してある。感度の高いものは航空機利用時の手荷物検査や宇宙線で感光するこ

4.フロッピーディスク

データの一時保管用に用いる。

とがあるので注意が必要である。

規格: 3.5"両面高密度(2HD)

対応可能なディスクフォーマットについては 8.2 節参照。予めフォーマットしておくことが 望ましい。5.25 インチ両面倍密度 2D(256)フロッピーディスクや MO が利用可能なステーションもある。

通常の XAFS 実験の場合ディスクー枚にスペクトル約 50 本分のデータが入る。多素子 SSD を 使用する場合はデータファイルが 250KB 程度になるので、MO の利用を推奨する。

5. その他

サンプルホルダー、サンプルセル、参照試料、テープ、筆記具、ノート、電卓、文具類等

データ解析ソフトをインストールしたノートパソコンを持って来ると、実験と解析を平行して行って、実験の方向性を判断したり、日頃慣れた環境で文書処理、データ処理等を行うこと出来、 便利である。また、所定の手続きをするとネットワークへ接続することも出来る。予め、持って 行く物のチェックリストを作ったり、持ち込み物品にマーキングしている研究グループもある。 リストやマーキングがあれば、実験後も余所の物品を誤って持って帰ったり、自分達の物品を忘 れて帰ったりする事も防げよう。

2.4 来所まで

実験の為に利用できるビームタイムは限られているので、予め充分に検討、準備した上で来所 すること。特に光学系のセッティング方法(主に XAFS 以外の実験の場合)を検討し必要な道 具を揃えなければならない。所属機関で実験をする場合と異なり、一寸したものの入手に手間取 ることもある。PF に行けば何とかなるだろうと考えていると思わぬトラブルに合うこともある ので注意すること。

XAFS の場合は以下の事を検討、準備する。 試料の形態、量(第二部 第2節参照) 試料の厚さ、調製方法、試料セル等(第二部 第2節参照) 測定に用いる各種パラメーターの計算(9.8節参照) エネルギー校正の方法(前回は何を標準としたか)(第二部第6節参照) 電離箱用のガスの選定(前回は何を使ったか) 測定の順序 特殊な試料ホルダーを用いる場合はその位置決めの方法

高次光除去用ミラーの照射角(第5節参照)

直ちに測定出来る様に予め試料を調製しておき、測定の合間は予備的な解析に当てることが好ましい。

以上の事をした上で来所、実験となるが一般の XAFS 実験の場合、1 2 人の人間がいれば充 分である。但し、20 時間程度より長いビームタイムの場合は交代で実験をする様にスケジュー ルを立てる事が望ましい。実験道具等の多い場合、廃液の持ち帰り等、車で来た方が便利なこと が多いが、帰路に過労運転とならない様に注意すること。実験機器の輸送に宅配便等を利用する ことも可能である*。また、計測器等についてレンタル機器**を利用すると便利なこともある。

実験用の小物、文具類は各自で用意することを原則とするが、PF側で準備する必要のある場合は早目にステーション担当者と連絡をとること。その他種々の事については PF ホームページの「共同利用の手引」及び「PF-XAFS ステーションの利用に当たって」を参照のこと。

ハッチ内での化学反応実験や液体ヘリウム等を必要とする場合は予め安全面等の検討、準備を 行う必要があるので、早い時点で担当者と相談すること。

2.5 放射光研究施設で

事務的な手続きについては PF のホームページ(http://pfwww.kek.jp/indexj.html)にある「共同利用の手引」を参照のこと。

実験中に**異常が発生**した場合は速やかに担当者と連絡を採るとともに、log book に記録をする こと。異常の原因を究明し、解決するためには異常が発生するに至った経緯を正確に理解する必 要がある。一般に異常が発生してからその前に行ったことを思い起こしても正確に思い出せない ので、日頃から詳細な記録を付ける習慣が必要である。

実験開始、終了に当たっては配分されたビームタイム中に以下のことを行うこと。

- ・前のグループは後片付け。実験中に付けたマーク、貼ったテープ等をはずし、パラメータファ イルを消去する。ガスの配管、信号線の接続等を変更した場合は元に戻す。実験終了時の条件 を log book に明記する。
- ・後のグループの内最低一人は1時間前までにステーションに来てステーションの状況の確認、 log book の記録を読み状況を把握すること。朝から始まるビームタイムの場合は前夜の内に前 のユーザーに状況を聞き、必要な機器があることを確認することが望ましい。
- ・前後のグループで引継を行い、ステーションの状況や物品の不足の無いことを確認する。
- ・実験中に気付いた事は備え付けの log book に詳細に記録する(トラブルについては再現テス トが行える様、条件等を明記する)。勤務時間中は担当者にも連絡する。
- ・実験終了時にはステーションの周囲の清掃、整理、整頓を行い、「利用記録」を提出する。
- ・ステーションには工具を備えてあるので、実験開始前、終了後に内容の確認を行うこと。過不 足がある場合は log book に記録すること。

次の実験グループが貴方同様にベテランであるとは限らないので、特殊なセットアップをし

^{*}週末、祭日は事務室が閉まっているため通常の宅配便は配達されない。これらの日に配達が必要な 場合は配達日時指定とすること。指定配達時刻に事務室前で待っていると一番確実である。

^{**} オリックス・レンテック(株) http://www.orixrentec.co.jp/等の会社では各種計測器、分析機器等のレ ンタルを行っている。

た場合は必ず標準的なセットアップに戻し、実験に支障がないことを確認すること。時間内に 出来なかった時は次のグループの実験が軌道に乗るまで面倒を見ること。

PF より借り出した物品は元の場所に返却すること。借りた人と返す人が異なると、所定外の 場所に返却されたり、放置される場合があるので、出来るだけ借り出した人が返却すること。ス テーション担当者から借用したものはステーションに放置せずに直接返却すること。実験の終了 が休日になる場合は予め相談すること。

2.6 実験終了後

実験終了後、所属機関へ戻ってデータの解析、解釈が行われるが、データの異常等に気付いた ときは連絡すること。

実験の結果として報文や学位論文が刊行された場合は**出版連絡票**(PFのホームページから入 カ可)と**別刷り**をPFに送付すること。可能であればステーション担当者にも送付されることを 希望する。報文には 1.7 節に記した報文の内該当するものを引用して頂くようお願いする。PF では毎年 Activity Report を刊行している。これへも成果を投稿すること。

課題の有効期間が切れた場合、または期限内でもそれ以上ビームタイムを必要としない場合は 「終了届」を事務室宛提出する。

2.7 その他

PFではXAFS関係の情報をpfxafsホームページに集めている。また、ここから IXS(International XAFS Society)等関連サイトへアクセスすることが可能である。

http://pfwww.kek.jp/nomura/pfxafs/ (日本語)

http://pfwww.kek.jp/nomura/pfxafse/ (英語)

英語版の内容は海外からのPF利用者向けに作っており、日本語版と異なる点がある。

また、XAFS 研究者間のコミュニケーションの手段としてメーリングリスト xsj を開設している。メーリングリストへの登録方法等は上記 pfxafs ホームページで説明してある。

XAFS に関心はあるが未だ実験をしたことのない方、実験はしたが問題を抱えている方々の相談にのる相談室として XAFS 相談室を開設している。XAFS に関連することであれば、実験・解析等のジャンルを問わない。回答には日本国内の XAFS 利用研究者(複数)が当たる。利用方法については上記 pfxafs ホームページを参照のこと。

- - -- -

PF 及び KEK のホームページの URL は

(PF)	http://pfwww.kek.jp/indexj.html	(日本語)
	http://pfwww.kek.jp/index.html	(英語)

- (KEK) http://www.kek.jp/index-j.html (日本語)
 - http://www.kek.jp/index.html (英語)

第3節 放射線防護・安全

PFの実験ホール内は放射線管理区域の一般管理区域に指定されており、空間線量率は 20μSv/hr 以下に抑えられている。入射時や 3GeV 運転時に 20μSv/hr を越える恐れのある場所 は(入射時、3GeV 運転時)立入禁止指定されている。従ってルールを守って実験を行っている 限りにおいて被曝の恐れは極めて小さい。放射線事故が発生すると、長期の運転停止を余儀なく されるので、一人一人の実験者が注意する必要がある。

放射線以外にも、化学安全、電気安全、ガスの利用等安全に関しては守るべきルールがある。 一般の実験室で起こった事故と比較して、放射線管理区域内での事故は大きな社会的影響を与え るので、注意が必要である。

3.1 インターロックシステム

各ビームラインには実験者の放射線防 護、ビームラインの保護などを目的とし たインターロックシステムが設置されて いる。ユーザーはハッチのそばにあるス テーションコントローラー、ハッチ内 の**ハッチ退室制御装置**を操作してハッ チ扉やビームシャッターの開閉を行う。

ステーションコントローラーは製作時 期によって彫刻パネル式のもの(BL-10B、 12C)、液晶表示式のもの(BL-7C、9A)が ある。使用する鍵は前者では二本(MAIN と AUX)、後者では OPC の一本のみで ある。操作は基本的に同一である。液晶 表示式の場合は一定以上の時間が経過す ると液晶表示が消えるが、液晶パネルに 軽く触れると再び表示される。 図 3.1.1 インターロック外観。ハッチ内に退室制 御装置がある。

図 3.1.2 BL-10B のステーションコントロー

DISTURBO

STATION 10B CONTROLLER

3.2 ハッチ扉の開閉

3.2.1 ハッチ扉を開ける

BL-10B、12C

- 1. ステーションコントローラーの MAIN キーが「READY」側になって いない時は右に回して READY にす る。
- ラーパネル図。 2. SHUTTER (DSS、下流シャッター) が CLOSE であることを LED で確認 する。CLOSE でない場合は SHUTTER CLOSE のボタンを押して閉じる。
- 3. AUX キーがステーションコントローラーにさしてある場合は STN-BY にして抜く。
- 4. AUX キーをハッチ扉の鍵穴に入れ、右に 90[°]回すと約 10 秒間解錠状態となるのでドアノ ブを回し、扉を引いて開ける。



BL-7C、9A

- SHUTTER (DSS、下流シャッター)が CLOSE であることを確認する。CLOSE で無い場合は SHUTTER CLOSE のボタンを 押して閉じる。
- 2. OPC キーがステーションコントローラーにさしてある場合は READY にして抜く。
- 3. OPC キーをハッチ扉の鍵穴に入れ、右に 90° 回すと約 10 秒 間解錠状態となるのでドアノブを回し、扉を引いて開ける。

3.2.2 ハッチ扉を閉める

BL-10B、12C

- 1. ハッチ内に人が居ないことを確認した後、ハッチ内のハッチ 退室制御装置の「退室」ボタンを押す(ブザーと回転灯が動 作する)。
- 2. 退室してハッチの扉を閉め、ブザーが停止し、ハッチ状態表 示盤の EXITING HUTCH の点滅が終わったら、AUX キーを左に回して抜く。
- 3. ハッチ外壁に取り付けてあるハッチ状態表示盤の「HUTCH CLOSED」の点灯を確認する。 点灯していない時は1からやり直す。
- 4. AUX キーをステーションコントローラーに戻す。

BL-7C、9A

- 1. ハッチ内に人が居ないことを確認した後、ハッチ内のハッチ退室制御装置の「退室」ボタ ンを押す(ブザーと回転灯が動作する)。
- 2. 退出してハッチの扉を閉め、ブザーが停止し、ハッチ状態表示盤の EXITING HUTCH の点 滅が終わったら、OPC キーを左に回して抜く。
- 3. ハッチ外壁に取り付けてあるハッチ状態表示盤の「HUTCH CLOSED」の点灯を確認する。 点灯していない時は1からやり直す。
- 4. OPC キーをステーションコントローラーに戻す。

3.2.3 搬入扉を開閉する

実験装置の搬出入のためにハッチの搬入扉を開ける必要がある時はステーション担当者または 運転当番に連絡する。この時、事故を防ぐためインターロックの鍵を運転当番が回収する。

搬入扉を閉め、放射光を利用可能とするためにはステーション担当者による安全確認が必要で ある。従って、搬入扉を開けることは 24 時間可能であるが、搬入扉を閉めて実験を再開出来る 時刻は制限されることに注意が必要である。

3.3 ビームシャッターの開閉

3.3.1 MBSを開ける

BL-10B、12C

ステーションコントローラーの MAIN キーを READY にし、「MBS OPEN REQ」ボタンを押す と約 10 秒程で開く。channel close 時^{*}や、ビームラインの異常等のためインターロックが MBS を自動的に閉めることはあるが、通常ユーザーが閉めることはない。



図 3.2.1 退室制御 装置

^{*}入射準備等のためにリングコントロール室からMBSを閉めることをchannel closeと称している。

BL-7C、9A

ステーションコントローラーの OPC キーを EXP または READY にし、「MBS OPEN REQ」ボ タンを押すと約 10 秒程で開く。他は BL-10B、12C と同じ。

3.3.2 BBS、DSSを開ける

1. ハッチの扉が閉まっていることを HUTCH CLOSED のランプで確認する。

- 2. MBS が開いていることを確認する(閉まっていれば開ける)。
- 3. ステーションコントローラーの AUX キー(液晶表示式では OPC キー)を EXP 側に回す。
- 4. BBS OPEN のボタンを押す。
- 5. BBS が開いたことを LED の表示で確認する。
- 6. SHUTTER OPEN のボタンを押す。
- 7. DSS が開いたことを LED の表示で確認する。

3.3.3 BBS、DSSを閉じる

- 1. SHUTTER CLOSE ボタンを押す。
- DSS が閉じたことを LED の表示で確認する。この状態でハッチの扉を開け、ハッチに入る ことが出来る。DSS の閉状態を確認出来ないうちにハッチの扉を開けようとしてはならな い。この様な操作をすると安全確保のためインターロックが働き、ビームを利用できなく なる。この時は運転当番に連絡し処置を依頼する。
- 3. 更に BBS を閉める時は BBS CLOSE ボタンを押す。
- 4. BBS が閉じたことを LED の表示で確認する。

3.4 その他放射線安全

- ・ビームラインの真空をリークしてモノクロメーター、ミラー等のビームライン構成要素の調整をする場合はステーション担当者に連絡し、担当者立会いのもとで行う。
- インターロックシステムに異常が生じた場合は速やかに実験ホール運転当番またはステーション担当者に連絡する。
- 赤色のビームダンプ(DUMP)スイッチを引くと全てのビームラインの MBS が閉じ、ビームも 落とされる。従って操作は緊急時のみに行い、誤って動作させない様注意する。
- ・ 所定の時間(10分程度)以上 DSS を閉じた状態が続くと、BBS が自動的に閉じられる。
- 密封放射線源を実験に用いるときは、事前にステーション担当者、放射線科学センターと打ち合わせ、所定の手続きをとることが必要である。法的には RI とみなされないチェッキング ソースも機構内では RI と同様に扱われ、無断で持ち込むことは出来ない。また、所定の手続きを経ることによって機構が所有する密封線源を使用することも出来る。

3.5 その他の安全関係事項

ここでは XAFS 実験に関係の深いことのみを記した。その他の安全に関するルールについては 「安全ハンドブック」等の資料[2]を参照のこと。

3.5.1 安全全般

実験に適した服装、履き物で実験を行うこと。スリッパ、サンダル等は脱げ易く、緊急時に行

動し難い上に怪我の原因となり易い(サンダル履きでハッチの扉に足を挟んで怪我をした例もあ る)。

「試料・化学薬品持ち込み・使用届」(3.5.3 参照)をビームライン使用状況表示板に掲出し、 現場責任者名、不在時の連絡先(携帯電話番号等)等を記述すること。

基本的な心得は企業等*の場合と同じである。大きな地震があった場合、ラックからの機器類の落下、ラックの転倒、照明器具の落下等が予想される。火災が発生した場合は短時間の内に実験ホール内の視界が失われることも予想される。避難路を予め確認しておくこと。また、ビームライン間の通路、ホール外周の通路は避難路になるので、物品を放置しないこと。

3.5.2 電気安全

加速器は高電圧、大電流を使用する装置であり、漏電、感電 等は致命的な損傷を与えることもある。また、XAFS 実験にお いても高電圧機器等を多用している。このため、細心の注意を 払って事故を防ぐ必要がある。特に放射線管理区域内で火災が 発生すると加速器の運転停止を余儀なくされ、場合に依っては 監督官庁の許可が下りるまで運転を再開できなくなる。

実験に必要な電力は指定された実験盤(分電盤)**からとり、 蛸足配線を行わないこと。配線をつなぎ込むときは実験盤担当 者の許可を得ること。ブレーカーに配線を接続する場合はプレ ーカーの電流容量以上の許容電流を持つケーブルで配線する 必要がある(表 3.5.1 参照)。また、各実験盤には漏電検出器 が付いている。検出電流値 30mA 以上で発報するので、まず リセットを押してみること。機器接続時・電源投入時に発報し、 リセット出来ない時はそれらの機器の接続を外し、速やかに運 転当番に連絡すること。装置持ち込み時やベーキング時には予 め絶縁抵抗計を用いて絶縁試験を行い、漏電の無いことを確認



図 3.5.1 実験盤。写真右隅 に付いているのが漏電検出 器。

すること。また、ブレーカーの容量以上の電流を取ることは出来ないので、機器接続前に確認す ること。緊急時にはブレーカーを遮断する必要があるので、**分電盤、実験盤の前に物品を置か** ないこと。

表 3.5.1 ブレーカの電流容量とケーフ	ル太さの関係
-----------------------	--------

ブレーカーの電流容量	ケーブル芯線の太さ
2 0 A	2 mm² 以上
3 0 A	3.5 mm² 以上
5 0 A	8 mm² 以上

3.5.3 化学安全

持ち込む化学薬品、試料については予め「**試料・化学薬品持ち込み・使用届**」を提出すること。 持ち込んだ毒物・劇物は施錠できる薬品庫に保管し、無人で放置しないこと。貸し出せる毒劇物 保管用の薬品庫は一つしかないので、施錠出来る薬品庫を持ち込むことが望ましい。PF所有の 毒劇物を使用する場合は使用後速やかに毒劇物保管庫へ返却すること。

^{*}大学における安全への取り組みでは不十分であるという意味で、企業等と記した。

^{**} 建屋の壁等に付いていて施設部が管理する分電盤を「分電盤」、その下流に設置してビームライン 担当者が管理する分電盤を「実験盤」と呼んでいる。

化学実験を行う前に緊急用シャワー、洗眼の場所を確認し、適宜安全メガネ、手袋等を着用す ること。廃液を伴う化学実験は化学試料準備室で行い、廃液は所定のポリタンクに回収すること。 実験後の試料をゴミ箱に捨てたため発火した例もある。また、某大学では廃液の分別が不適切で あったために、廃液処理の職員が命を落としたこともある。

排ガスを伴う実験はドラフト内で行うこと。実験ホール内で CO 等のガスを使用する場合は「特 殊(可燃性・毒性・特殊材料)ガス使用ガイドライン」(PFホームページからアクセス可)に 従い、予め「特殊ガス使用届」を提出すること。実験ホール内では多くの実験が同時に行われ ているので、排ガスは無害化後、有害ガス用排気ダクトへ放流する。申請と異なる方法で実験し、 オゾンガスが爆発して怪我をした例もある。一歩間違えれば失明というケースであった。

3.5.4 寒剤

液体窒素を扱うときに軍手を使用しないこと。液体窒素がかかると凍傷になる。また、液体窒 素汲み出し中はその場を離れないこと。あふれると酸欠警報が発報する。北海道大学で液体窒素 による酸欠で死亡した例もある。

液体窒素を床にこぼすと床が破損する。SSD に液体窒素を補充する場合等は直接液体窒素が 床にこぼれないように注意すること。

3.5.5 クレーン操作等

PF のクレーンを使用するにはクレーン等安全規則第 21 条に規定する特別教育修了等の資格 を有した上で、予め「**クレーン及び特殊自動車使用願**」を提出して許可を得る必要がある。ま た玉掛け業務(クレーンに荷を釣る作業等)を行うには玉掛け技能講習修了の資格が必要である。 フォークリフトについても同様である。学生が無資格でクレーンを操作して高価な実験用機器を 壊し、責任を感じて自ら命を絶った例もある。

繰り返しになるが、放射線管理区域内で事故を起こすと極めて大きな影響をもたらす。また事故 の after effect として手続きが煩雑になることもある(誓約書はその例である)。くれぐれもルー ルを守って安全に実験を行うようお願いする。

第4節 モノクロメーター

4.1 モノクロ前スリットの調整

モノクロメーター(monochromator)の直前に設置してある四象限スリットをここではモノクロ 前スリットと呼ぶ。BL-9A では collimation mirror の前に設置されている。このスリットはモノ クロメーターに入射するビームの形を決めるもので入射ビーム中心に合わせて使用する。後述す るようにかなり余裕を持って設定されており、BL-7C 以外では実験者が調整をする必要はない。 このスリットを動かすとモノクロメーターから下流のセッティングを再調整する必要がある。

BL-7C では集光をしない場合は水平方向の幅を狭く設定している。Sagittal focus を利用する場合は水平方向の広がりを調整する。

モノクロメーターの分光結晶上で、入射X線の当たっている場所と当たっていない場所では熱 の流入量が異なる。分光結晶は後述するように間接水冷されているが、僅かに温度勾配が生じ、 結晶にも僅かながら歪みが生じる。従って、モノクロメーターに入射する前のビームは実際に利 用するビームよりも大きめに整形する方が良い。

このスリットのうち特に上下方向のビーム形状を決める刃はビーム位置モニターとしての機能 も果している(図 4.1.1 参照)。従ってこの記録を見るといつどれ位ビームが上下方向に動いた か分かる。この様にビーム位置モニターとしての機能も持っているのでこのスリットの位置を 動かす時にはその記録(時刻、リングの蓄積電流値、動かす前後のマイクロメーターヘッドの 読み)を log book につけること。記録時は上、下、BL6 側、BL8 側等の名称を使い、左右等の不 鮮明な表現をしないこと。操作するときは二枚のスリットの刃をぶつけないようモノクロメータ ー直前の蛍光板を観察しながら動かす。



図 4.1.1 スリットを用いたビーム位置モニター

このスリットの位置が正しいか否かは以下の方法のどちらかによって簡単に点検できる。

(1) ビーム位置モニターの読みが log book に記されている当該期の運転開始時の値と比較して大きくずれている場合は調整が必要である。この値はモノクロメーターのそばにあるディジタルパネルメーターに表示されている。またこの値はペンレコーダーに記録されているのでいつからビーム位置が変動したかを知る事が出来る。モニターの感度はステーションによって異なるが、±0.2mm 位の間に入っている時は一般にはそのままにしておいた方がよい(スリットの幅によっても変化するし、スリットの軸も熱膨張する)。但し、表示される値はス

リットの開口に依存するので、同一条件下で比較すること。

(2) モノクロメーターとスリットの間に蛍光板を挿入してビームの位置、形状を観測できる場所 があるのでここでスリットの刃を上下方向にやや開いてビームの観察をする。蛍光板はステ ンレス板の裏側に貼ってあり、ビームはステンレス板によって吸収された後に蛍光板に当た るのでビームの芯(強度が高い、エネルギーが高い成分が多い)の部分が観測できる。その 状態から上下を均等に切る様にスリットの刃を動かせば良い。

4.2 X線光学の基礎

結晶に入射した X 線は Bragg の式(4.2.1)に従って回折される。

$$2 d \sin \theta = n \qquad (4.2.1)$$

ここで d は格子面間隔、 B は Bragg 角、 は X 線の波長である。これは結晶内で1回だけの散 乱波の干渉を考えたものであり、結晶構造解析等の場合には充分に良い近似であるが、モノクロ メーター結晶の様に大きな完全に近い結晶の場合は必ずしも充分に良い近似といえない。例えば、 この Bragg の式で高次光も同時に回折されることは理解できるがいわゆる detuning によって高 次光が取り除けることは説明できない[3]。

モノクロメーター内での挙動を説明するためには散乱波の多数回(無限回)の干渉を考える必要がある(動力学的回折理論、dynamical theory)。この場合、吸収が無い対称反射という条件では回折強度曲線の中心は上記の [®]から だけずれる。

$$= (r_{e} {}^{2}F_{0r}) / (sin 2 {}_{B} \cdot V) \qquad (4.2.2)$$

ここで $\mathbf{r}_{e} = \mathbf{e}^{2}/(\mathbf{mc}^{2})$ 、 V は単位格子の体積、 F_{or} は結晶構造因子である。高次光の波長が $\lambda_{n} = \lambda_{1}/n$ であることを思い起こすと、回折強度曲線の中心が回折の次数によって変わることが理解できる。 またここでは式を示さないが、高次光の回折強度曲線の幅は粗い近似ではやはり \mathbf{n}^{-2} で減少する。 図 4.2.1 に原理図を示す様に だけ平行度をずらした 2 枚の結晶の基本波は影の部分だけ重なる が、高次光は重ならない。このようにして高次光の影響を抑えることが出来る。ちなみに Si(111) 面の 1.54Å (8keV)の X 線に対する回折強度曲線 (rocking curve)の幅(ω_{s})は 7.4 秒である。 1 秒 は約 4.8 × 10⁻⁶ rad (1 m先で 4.8 µ mの偏角)であることを思うと、小さな角度であることが理



図 4.2.1 An off-set harmonics-rejection monochromator. (a) Geometry of the monochromator. Actually the magnet and the coil are replaced by a PZT and a stepping motor. (b) The principle of harmonics rejection. Perfect crystal reflection curves for the fundamental (n=1) and the harmonics (n=2,3) are approximated by rectangular boxes. ε : off-set or misalignment angle. The shaded area represents delivered X-rays (Hart and Rodrigues 1978). 文献 3 より。

解できよう。

4.3 二結晶モノクロメーター

X線用のモノクロメーターとして最も単純なものは一結晶モノクロメーターであるが、この場合はモノクロメーター結晶と試料、検出器をθ-20駆動しなければならない。放射光を光源とする XAFS 実験の場合は装置も大きくなり、また光源の偏光特性を生かそうとすると水平軸のθ-20ゴニオメーターが必要となり、実用的でない。このため放射光を単色化してX線吸収スペクトルを測定する場合は一般に二結晶モノクロメーター(double crystal monochromator)が用いられる。

二結晶モノクロメーターの特徴は

- 1. 単色化されたビームの出射方向が一定である。このため短時間にX線のエネルギーを変え られる。
- 2. 回折強度曲線の裾が弱くなる。
- 3. detuning によって高次光を除去できる。

等があげられ、NSLS の四結晶分光器[4]や分散型 XAFS 用の分光器[5]を除いて殆ど世界中全ての XAFS 用のビームラインで二結晶モノクロメーターを採用している。

二結晶モノクロメーターと呼ばれるものもチャンネルカットモノクロメーター(channel-cut monochromator)と狭義の二結晶モノクロメーターに大別される。前者は一つの結晶の中に溝を切って二回の反射を実現するものであり、BL-10B で使われている。この特徴は 結晶格子面の平行度は原理的に確保されていて、掃引中に変化しない、 取扱いが簡単という反面、 detune 出来ない^{*}、 出射光の高さが Bragg 角によって変化する、 幾何学的に低エネルギー側の限界が決まる、といった難点もある。BL-7C、9A、12C では出射ビームの高さ、方向を一定にするため後者の意味での二結晶モノクロメーターを採用した。

4.4 チャンネルカットモノクロメーター

BL-10B では通常 Si(311)チャンネルカットモノクロメーター(channel-cut monochromator)を使用 している。BL-10B で Si(111)を使用する場合はチャンネルカットモノクロメータと同様に配置し た二結晶モノクロメーターを用いている。この方式では二枚の結晶の間隔が固定されているので、 ブラッグ角を θ 結晶表面の間隔を D とすると出射ビーム高 h は

 $h = 2D\cos\theta$

(4.4.1)

[BL-10B]

に従って変化する。BL-10B ではこの出射ビーム高の変化に追随するようにハッチ内の電動昇降 ステージを動かし、試料上のビーム位置が一定になるように制御している。Si(311)チャンネル



図 4.4.1 channel-cut monochromator での光路

カット結晶の場合、D = 9.5 mm 程 度であり、その場合のビーム高の変

^{*} 溝部に更にスリットを加工し、チャンネルカットでありながらdetuneを可能としている例もある。

表 4.4.1 出射ビーム高の変化

		θ	<i>h</i> /mm
		6	18.90
		10	18.71
	on o chromoton) ブけ	15	18.35
		20	17.85
出射ヒームの高さを一定に保つために の変	化と同時に一枚の	25	17.22
結晶の光軸に平行な方向の距離(x)を次の式	に従って変化させ	30	16.45
ている。		35	15.56
<i>x=h</i> /tan(2)	(4.5.1)	40	14.55

ここで は Bragg 角、h は入射ビームと出射ビームの高さの 差(水平軸の場合)であり、PFでは通常25mmを採用している。

この条件を実現する方法としては とともに*x*を独立に制御する方法、 と*x*が自動的に 変化するようにメカを工夫する方法の二通りがある。前者は SSRL の JUMBO や PF の BL-11B、 10C、14A 等で用いられている[6]。JUMBO 型では超高真空に適した装置を作り易く、自由度が 大きいため結晶の熱膨張をキャンセルするような動きも出来る反面、二結晶が衝突したり、うっ かりすると回折光を見失ったりしがちである。

これに対して機械的に二つの結晶をリンクして(4.5.1)式の動きを実現する方法もある。これに もいくつかの方法があるが、一つはボールネジによる送りとガイドを組み合わせた方式[7]、も う一つはフランスの LURE で開発された方式で一結晶の回転にともなって他結晶が特殊な形状 に切り出したガイドの上を動く方式である[8]。PFの XAFS 実験用ステーションでは後者をベー スにしてモノクロメーターを製作した[9]。

BL-7C で使用しているモノクロメーター内部の側面図を図 4.5.1 に示す。第二結晶表面はモノ クロメーターの回転主軸上にあり^{*}、第一結晶は x、y ステージ上にあり回転にともなって二つの ガイドに沿って動く。 θ の可動範囲には表 4.5.1 に示す制約がある。第一結晶は液体のインジウ ム・ガリウム合金を介して水冷された銅ブロックに貼付けられ、ビームが当たったときの温度上 昇は1度以内に抑えられている。第二結晶との平行度(Δθ1)はパルスモーター等で制御でき、 第一結晶に関してはそのアフリ(光軸周りの回転、 Φ_1)、第二結晶との面間距離(D_1)、また第 二結晶についてはそのアフリ(Φ_2)及び結晶のサジタル方向の曲げ(B(BL6)、B(BL8))、結晶



図 4.5.1 モノクロメーターの機構(文 献9より)

A mechanism to keep the exit-beam height constant. The x and y axes are taken on the reflected beam from the second crystal and perpendicular to it, respectively, by choosing the position of the rotation axis as the origin.

BL-12Cの分光器では第一結晶が回転中心にあり、ビームは第一結晶によって斜め下方に振り下げら れる構造となっている。

の面内での回転(ROT)について DC モーターが付いており外部から制御できる。またΔθ₁、ROT についてはピエゾ素子も付いており、微調整が出来る。各ビームラインに設置された二結晶分光 器の制御の自由度と機構を表 4.5.2 に示す。モノクロメーターの性能に関しては文献 10 を参照 して頂きたい。BL-9A、12C で使用している二結晶分光器も同様の原理である。

表 4.5.1 各ビームラインに設置された二結晶分光器のθの調整範囲

ビームライン	出射光軸を一定にする範	出射できる範囲
	西	
BL-7C	5° θ 70°	同左
BL-9A	5° θ 70°	同左
BL-12C	8 ° θ 50 °	7° θ 50°

表 4.5.2 モノクロメーターの自由度と制御機構

軸名称	動き	BL-7C	BL-9A	BL-12C
$\Delta \theta_1$	二結晶の平行性	パルスモーター、	パルスモーター、	DCモーター、
		PZT	PZT	PZT
1	第一結晶のアフリ	DC モーター	DC モーター	DC モーター
D 1	二結晶の間隔	DC モーター	DC モーター	DC モーター
2	第二結晶のアフリ	DC モーター	DC モーター	なし
ROT	第二結晶の面内回転	DCモーター、PZT	なし	なし
B(BL6)	結晶の弯曲(BL-6 側)	DCモーター	なし	なし
B(BL8)	結晶の弯曲(BL-8 側)	DCモーター	なし	なし

4.6 sagittal focusing

[BL-7C]

Sagittal focusing は **BL-7C** で採用している集光方法である。図 4.6.1 に示すように回転楕円体面 に沿って分光結晶を曲げれば 2 次元的に X 線を収束する事が出来る。詳細は文献 11 を参照して 頂くとしてこの場合の sagittal (サジタル)方向の半径 *R*。と meridional 方向の半径 *R*mは以下 の様に表わされる。

tan	$= [(F_1$	$-F_{2})/$	(F_{1})	+ F2)] tan	
R_{m} =	= F_1 /sin(+)		(4.6.2)
R s =	$= F_1 \sin($	_)		(4.6.3)

この式から見ても分かるように Rm, Rs ともに の関 数となるが、結晶を弯曲して回転楕円体面を作ること は出来ず、*R*_™ = のケースのみ実現している。こ の場合の収束条件は $F_1:F_2 = 3:1$ であり、従って水 平方向の像の倍率は 1/3 に、水平面内の角度発散は 3 倍になる。また式から明かな様に *F*₁が大きくなるほ ど(光源から遠ざかるほど)、θが大きくなる程(エ ネルギーが下がるほど) R₅は大きくなり、実現が容 易になる。この辺りが光源から光学素子までの距離が 大きくなる第三世代 X 線リングで sagittal focus が多用 されている理由であろう。但し、光源からの距離が大 きくなるほど大きな結晶が必要となる(4mrad × 16.3m=65.2mm)。また θ を大きくするためには格子 面間隔の小さな結晶面を用いなければならず、必然的 に回折強度曲線の幅が小さくなり、種々の技術的困難

(4.6.1)

表 4.6.1 各 Bragg 角に対するサジタル

	半径	
₅/deg	<i>E</i> /eV	R_{s}/m
30.0	3954.2	3.90
28.0	4211.4	3.68
26.0	4510.1	3.45
24.0	4860.9	3.22
22.0	5277.8	2.98
20.0	5780.7	2.73
18.0	6398.1	2.47
16.0	7172.9	2.21
14.0	8172.5	1.95
12.0	9509.4	1.68
10.0	11385.7	1.40
9.0	12638.6	1.27
8.0	14206.1	1.13
7.0	16223.2	0.99
6.0	18914.6	0.85
5.0	22684.8	0.71


図 4.6.1 (文献 11 より) Geometry of a double curved surface for near ideal focusing of photons by Bragg scattering. A singly curved surface approximation is made with a cylindrical bend to the radius N.

が生じて来る。

薄い平板結晶を sagittal 方向に弯曲した場合、meridional 方向にも弯曲が生じる。これを防ぐ ために BL-7C では図 4.6.2 に示すようにリブが付いた菱形結晶の対角線を固定し、頂点を押す ことによって弯曲させている。このため、実際に得られるフォーカスの大きさは光源の 1/3 より 大きく、このリブの幅で決まってくる。

BL-7C の場合は F_1 = 16.3m、 F_2 = 5.4m であり、Si(111)面を用いた場合、各 Bragg 角に対し て表 4.6.1 に示す半径になる。実用エネルギー域で如何に小さな半径になっているかご理解頂け よう。通常使用している菱型の結晶は = 9°で割れたことがあるため現在はここをリミットと している。

Sagittal focus 式のモノクロメーターは広い水平アクセプタンスを持っていて、幾何学的なビームライン配置も比較的容易で、且つ比較的安価に大強度のビームランを建設出来るという特徴を有し、BL-7C で採用している(旧 BL-6B でも採用した)。一方で、sagittal 集光の半径は使用するX線のエネルギーの関数となり、また、弯曲軸と光軸の平行性をきちんと調整しないとエネルギー分解能の劣化につながるため[12]、調整に習熟を要することが難点である。使用するX線のエネルギーに応じて sagittal 半径を制御する dynamic focus 方式もテストしたが、sagittal 半径を変えた時に二結晶の平行性も変化し、再調整が必要となるため共同利用には採用しなかった。

4.7 制御系

主軸の回転(θ_0)は5相パルスモーター*(500pulse/rot)の動きを第一のウォームで 1/144、 第二のウォームで 1/180 に減速している。このため1パルス当りの主軸の送り角は 360 °× 1/500×1/144×1/180 = 1/36000 ° = 0.1"になる。このモーターへはパルスモーターコントロー ラー(ツジ電子 PM4C-05)から制御パルスが送られる(CW で高角)。主軸の動きは 0.0001 ° 読みのインクリメンタル式ロータリーエンコーダー(Heidenhain ROD-800 + VRZ460 または ND261)でその角度を読みとることが出来る。このエンコーダーで測定しているのは初期設定か らの変化分であって、絶対角ではないので実験開始前に角度の較正を行う必要がある。**BL-10B** ではパルスモーターコントローラーにツジ電子 IPM2C-01 を使用し、ローターリーエンコーダ ーはない。

Δθ₁ はやはり 5 相パルスモーター(約 0.1"/p、**BL-12C** では DC モーター駆動)とピエゾ素子 で駆動される。ピエゾ素子を用いた時の可変範囲はパルスモーターを用いた時よりも狭いが、滑

^{*} 英語ではpulse motorではなくstepping motorと言う。

らかに連続的に変化させる事が 出来る。通常はピエゾ素子で調 整出来る範囲内にある。**BL-10B** では二結晶分光器を取り 付けた時のみ DC モーターを用 いて $\Delta \theta_1$ を調整している。

Φ1、Φ2、D1、B(BL6)、B(BL8)、
 ROT は DC モーターコントロ
 ーラー(ツジ電子 DM3C-01
 等)で制御され、各々の軸に付
 いたポテンショメーターの信号
 から位置を読みとることが出来る。



図 4.6.2 sagittal focus 用分光結晶。Anticlastic bending を防ぐ ため結晶にリブが付いている。 X 線は図の上面で回折される。

4.7.1 パルスモーターコントローラー (ツジ電子 PM4C-05)

4 系統のパルスモータードライバーの制御機能、パルス計数機能を持つ。各 SW の機能を以下 に示す。

- 1. REM/LOC: Remote/Local の切り替え。XAFS 測定中は Remote、手動操作中は Local に設定。
- 2. CONDITION:使用禁止。各駆動軸のパラメータ設定に用いる。
- 3. CH SELECT: 駆動軸の選択。点灯したチャンネルが駆動する。複数点灯している時はそれ らのチャンネルが同時に駆動する。
- 4. PRESET: 使用禁止。カウント数のプリセットに用いる。
- 5. START: Local モードでパルス送りスタート。
- 6. STOP: パルス送り停止。Remote モードでも有効。
- 7. JOG: Local モードでインチング動作時に使用。
- 8. INDEX モード切替 SW 及び表示: 絶対位置移動(ABS)、相 対位置移動(REL)、原点移動(HP)、連続パルス出力(SCAN)の切替。SCAN では無点灯。 絶対位置移動では目的地のパルス数を、相対位置移動では移動量のパルス数(CW 方向が正、 CCW 方向が負)を当該チャンネルの SET DATA サムホイール SW で設定する。
- 9. SPEED 選択及び表示: High、Middle、Low のスピード切替。
- 4.7.2 パルスモーターコントローラー(ツジ電子IPM2C-01) [BL-10B]

2 系統のパルスモータードライバーの制御機能、パルス計数機能を持つ。各 SW の機能を以下 に示す。

- 1. REMOTE/LOCAL: XAFS 測定中は REMOTE、手動操作中は LOCAL に設定する。
- 2. A/A+B/B: 駆動するチャンネルの選択。A はステージ、B はモノクロメータ主軸、A+B は双方。
- 3. SS/SCAN/INDEX: SS は single step。SCAN は START を押してから STOP を押すまで連続駆動。INDEX はサ ムホイール SW で設定したところまで駆動。
- 4. CW/CCW: モーターの回転方向の設定。
- 5. START: スタート
 6. STOP: ストップ

図 4.7.2 IPM2C-01

この時代は-の付いたサムホイール SW を入手出来なかったため、パルス数は 0~9999999 の範

囲しか表示できない。

図 4.7.1 PM4C-05

4.7.3 **ロータリーエンコーダー**(Heidenhain ROD800+VRZ460/ND261)

モノクロメーターの Bragg 角の計測、表示を行っている。但し、絶対角度ではなく、設定値からの相対角度である。

カウンターに数値をロードするときはテンキーで数値を設定し、ENT を押す。設定可能な分 解能は 0.0001°である。誤ってカウンターをリセットしないように注意すること。

次のような症状が出るときはトラブルであるので 発生時刻、 症状が出る前の操作、 症状、 カウンターの数値を LOG BOOK に記入した上で、電源を切り(SWは背面)再投入しカウン ターに数値をロードする。

- 1. カウンターの数値が点滅する。
- 2. エラー表示が出る。但し、ND261 で出る Error 03 は PC との通信不成立に依るもので、CL を押すことによって解除出来る。

4.7.4 DCモーターコントローラー(ツジ電子 DM3C-01)

DC モーターを駆動するとともに、ポテンショメーター の位置を読む。またリミット SW が動作した時は動作を 停止する。BL-7C の B(BL6)、B(BL8)、ROT については ポテンショの読みを入力とし、ウインドコンパレーターを 用いてリミットを働かせている。 [BL-7C、9A]



図 4.7.3 DM3C-01

1. DISABLE モードではモーターは動かない。

2. INCH モードでは CW または CCW の SW を押している間のみ動く。

3. CONT モードでは CW または CCW の SW を押すと STOP SW を押すまで動く。このモード は危険なので慣れない人は使わないこと。

4. 動作後は必ず DISABLE モードに戻しておくこと。

4.7.5 ピエゾ素子用電源

 $\Delta \theta_1$ 制御用には PHYSIK P-862 (BL-7C、12C)、同 E-111 他 (BL-9A)を使用している。この他に BL-7C では sagittal focus 用結晶の面内回転調整用に同 P-263 を使用している。 $\Delta \theta_1$ 制御

P-862、E-111 はピエゾ素子の伸びを歪みゲージで計測し、 一定の長さに保つようにフィードバックを掛けている。通常、 VC/EC は EC(Expansion constant)、 VOLTS/MICRONS は MICRONS に設定する。DC-LEVEL と書かれたつまみで PZT 素子に印加する電圧を制御する。

Tune optimize(第 9.9 節参照)を使用するときは ANALOG IN に PC の DAC 出力を接続する。



図 4.7.4 ピエゾ素子制御 用電源 P-862。BL-9A は 異なる型を使用してい る。

面内回転制御

P-263 にフィードバック回路は無いので、調整後ドリフトする事があるので注意すること。 1. 出力電圧の制御は下側の該当するチャンネルのポテンショメーターのつまみで行う。

- 2. 出力電圧の読み取りは上のロータリー SW でチャンネルを選択して読む。
- 3. 左の LEMO コネクターは出力用、下の BNC コネクターは信号入力用である。
- 4. 各チャンネルは次の様に接続されている。 A:未使用、 B: ROT、 C: 未使用

4.8 調整法

ここでは結晶の交換には触れず、ユーザーの誤った調整や sagittal focus の利用等によって狂ったアラインメントを正しく直すことに重点を置いて記す。

4.8.1 回折像の確認

モノクロメーター上流のスリットの調整については 4.1 節参照のこと。

通常は回折像を見失うことはないはずであるが、Δθ₁を誤操作した場合等は回折像を見つける ことから始めなければならない。以下の二段落は BL-10B 以外に適用される。なお、ここではハ ッチ内の電動昇降ステージの高さは適切に調整されていることを前提条件とする。

まず、**誤操作をしても元に戻せるように、パルスモーターコントローラーの値、ピエゾ電圧コントローラーの値を log book に記録する**。通常はΔθ₁ が大きくずれていることは無いはずであるので、まずピエゾ素子コントローラを用いて I₀の強度が最大になるように調整する。この時、 X線のエネルギーは 9keV 前後が調整し易い。

上記の方法でビームが見つからない場合は、モノクロメーター下流の蛍光板を挿入して単色ビ ームの強度が最大となる様にピエゾ素子を用いて二結晶の平行度($\Delta\theta_1$)を調節する。これで回 折X線ビームが見つからない時は、BL-7C、9A では次にパルスモーターコントローラーの操作モ ード切り替えスイッチを押してを LOCal とし CH B のみを押して点灯した状態にし、SPEED=Low、 RUN MODE = REL で緑色のシーソースイッチを上か下へ倒して $\Delta\theta_1$ を変えて強度が最大となる 場所を探す。この操作は二人で行うか、一人で行うときはモニターテレビを用いて行う。正しい 回折は Bragg 角 θ_0 を変えても消えないが、他の面による回折は少し θ_0 を変えると消えるので区 別できる。

BL-10B の場合は通常は△θを調整する必要はないが、Si(111)二結晶分光器を利用する場合には 必要になる。ハードウェアが他のステーションと異なり、DC モーターを用いて調整する。

回折 X 線ビームが見つかったら、 I_0 用電離箱前のスリットの上流側にリナグラフを貼り、ビーム位置を確認する。この像の位置を参考に I_0 が最大になるように、電動昇降ステージの高さを合わせる。この時は I_0 用電離箱前のスリットは鉛直方向 1mm 程度、水平方向は最大の開口とする。 $\Delta \theta_1$ の調整と電動昇降ステージの高さ調整を繰り返し、最適な条件に調整する。

4.8.2 非収束光学系

ルール

- |・日時、調整前後のパルスモーター、ポテンショの読み、スリット位置
- を全て log book に記録すること。
- ・BL-12C、9A では∆θの調整以外は行わないこと。

Sagittal 集光を使用しない場合は二結晶の平行性の調整が重要である。Bragg 角方向にずれて いると強度を失うし、光軸回りにずれていると Bragg 角を変えた時にビームが水平方向に移動 する。BL-10B で Si(311)面を使用している場合はこれらが狂う要因が無いので、以下の内 1~3 の調整は必要ない。モノクロメーターの調整手順を示すと

- 1. 二結晶の平行度 (Δθ₁)を合わせ、最大強度を探す (4.8.1 参照)。
- モノクロメーター上流のスリットの値を log book に記録した上で、スリットを光軸中心部で 1mm 角程度に絞る。
- ハッチ内の I₀前スリットを除き、試料位置付近に蛍光板(ハッチ内の工具箱引き出しに常備、 暗所保存のこと)を取り付け、θを変えてもビームが水平面内で動かないように第二結晶のア フリ(Φ2)を調節する。蛍光板は TV カメラを介して見る。この動きは低角側で小さく、高

角側で大きくなる。

- 4. ビームと光学ベンチが平行になるようにベンチの位置を調整する(光学ベンチの上下流にある水平調整用のネジを利用)。これはI用電離箱の入り口側にリナグラフを貼り、光学ベンチの上流側と下流側で露光して位置の確認をすれば良い。BL-7C、10B では完全に非集光であるので容易にずれが分かる。BL-9A、12C ではミラーによる集光の効果が出るため、大きくずれない限り余り気にしない方が良い。
- 5. このビームの位置にハッチ内のスリット位置を合わせる。スリット位置はSLIT CONTROLLER で調整できる。必要に応じてステージの高さも調整する。スリットの高さを変えるとビーム が電離箱の中心から外れることがあるので、ステージの高さを調整すること。
- 6. 電離箱をセットして、再度最大強度になるようにΔθ₁を調節する。
- 7. 必要に応じて∆θ₁を調節して高次光を抑える(detune)。余り小さな detune では二結晶の平行度の変化によって高次光の割合が変化するし、余り大きく detune すると強度が減少する上に高次光の割合も増大する。通常 I₀の強度が最大強度を得る様に調整した時の 60%程度になるよう調整する。どのエネルギー域で detune が必要かはビームライン光学系、試料の濃度・厚さにも依存する。後述の各ビームラインに関する記述を参考にすること。
- 4.8.3 sagittal 収束光学系

[BL-7C]

 ルール
 ・日時、調整前後のパルスモーター、ポテンショの読み、スリット 位置 を全て log book に記録すること。
 ・実験終了後は 4.8.2 の方法で非収束光学系が正しく調整されていること を確認すること。

4.8.2 節と重複する部分の記述は簡略にしてあるので、そちらも参考にすること。

- 1. モノクロ前スリットを水平方向に開く。
- 2. Bragg 角(θ)を掃引するとフォーカスが変わるので、測定範囲内で最大強度を得られるように 調整する。通常は吸収端から 300~500eV 程度高いエネルギー域にモノクロメーターを設定 し、best focus が得られるよう調整する。
- 3. ハッチ内のスリットを除き、試料位置付近に蛍光板(ハッチ内の工具箱引き出しに常備、暗 所保存のこと)を取り付ける。試料位置でのフォーカス形状を見ながら、最小のスポットサ イズになるように B(BL6)、B(BL8)を均等に動かす。蛍光板は TV カメラを介して見る。
- 4. 結晶の全面で同じ Bragg 条件を満たす様に第二結晶の面内回転(ROT)を調節する^{*}。実際上は 蛍光板の代わりに電離箱を置いて最大強度が得られるように∆0₁ と ROT を調整する。この調 整が悪いと分解能も強度も落ちる。モノクロ直後の蛍光板で結晶全体が回折条件を満たして いることを確認する。
- 5. θを変えてもビームが水平面内で動かないように、左右が均等に変化する様に第二結晶のアフ リ(**2**)を調節する。
- 6. 測定に使用するエネルギー範囲でのビームサイズ、形状の変化を観測する。
- 7. このビームの位置にハッチ内のスリット位置を合わせる。スリット位置はSLIT CONTROLLER で調整できる。必要に応じてステージの高さも調整する。

X線の第二結晶への入射角がビームの当たる位置によって異なっていると、強度、エネルギー分解 能が劣化する。この様な場合にrocking curveを測定すると、結晶上の測定する場所によって、ピーク 位置が変化する。これらが結晶上の場所に依らず同一になるように調整することが望ましい。表現を 変えると、全ビームを受けた状態でrocking curve幅が最小になるように調整すれば良い。

- 再度最大強度になるように△θ₁、ROT を調節する。これらを動かすと集光ビーム位置も僅か ながら変化するので、7、8を2~3回繰り返し最適条件とする。
- 9. 必要に応じてΔθ₁を調節して高次光を抑える(detune)。
- **10**.結晶を曲げた場合は安定するのに数時間を要することがあるので、時々∆θ₁を調節する。この時僅かながらエネルギー軸がずれるので注意すること。
- 注 · sagittal focus は 4.6 節に記したように > 9° でのみ有効である。

4.8.4 sagittal 収束光学系を用いた測定例

強度、フォーカスによる利得や高次光の割合については第6節や1.7節に記した文献を参照の 事。ここではその中から、銅箔の吸収スペクトルの例を図4.8.1に示す。この図から分かるよう に、うまく調節出来ると殆ど平板結晶と分解能の差が無いスペクトルを得ることが出来る。この 時の光子束の利得は約14である。一方、調整が良くないと、分光結晶上のX線が当たる場所に よって Bragg 角が異なるためにエネルギー分解能が悪くなり、銅吸収端のハンプが観測できな くなる。



図 4.8.1 (文献 10 より) Comparison of energy resolution at the K-edge of copper foils. (a): with Si(311) channel-cut monochromator; (b): with bulk (flat) Si(111) double crystals and (c): with Si(111) double crystal at sagittal focusing condition.

第5節 ミラー

5.1 ミラーの必要性

XAFS は吸収スペクトルであるので、入射光が高次光や散乱光を含んでいるとスペクトルの形状が歪む。しかもモノクロメーターの掃引によって二結晶の平行度が僅かに変わるために高次光の割合はスペクトル中でも変化する。またグリッチ等(第二部 4.5 節参照)によっても高次光の割合は変化する。高次光の割合が連続的に変化する場合はスペクトル上に現れないため、正しいスペクトルを測定している気になるが、無視できない高次光が入っている限り正しいスペクトルを得たことにならないことは自明である。

透過法で実験をする場合、Io、Iの各電離箱で検出される信号強度は

$$I_{0} = \alpha(I_{0}, 1) + \Sigma \mathbf{m} \alpha \mathbf{x}_{m} (I_{0}, \mathbf{m})$$

$$I = \{1 - \alpha(I_{0}, 1)\} \exp(-\mu_{1}t) \alpha(I, 1) + \Sigma \mathbf{m} \mathbf{x}_{m} \{1 - \alpha(I_{0}, \mathbf{m})\} \exp(-\mu_{m}t) \alpha(I, \mathbf{m})$$

$$\mu t = \ln(I_{0} / I)$$
(5.1.1)

ここで、 \mathbf{x}_{m} は m 次高調波の基本波(m=1)に対する割合、 $\alpha(\mathbf{I}_{j},\mathbf{m})$ は \mathbf{I}_{0} 、I 各検出器での m 次波に 対する検出効率、 $\exp(-\mu_{m}t)$ の項は試料に対する m 次波の透過率である。m 次波は基本波と比較 して m 倍のエネルギーを有しているため電離箱中で m 倍の電流を生成する。このため m が掛か っている。通常使用している Si(111)、Si(311)を分光結晶に用いる場合は消滅則のため 2 次波の 割合は無視でき、4 次以上の割合も無視できることが多いので、 $\mathbf{m}=1,3$ の場合のみを考慮すれば 良い。例えば \mathbf{I}_{0} に窒素を、I に 15%アルゴン + 85%窒素を入れた電離箱を用いて Ti の K 吸収端 付近(E = 5keV)の XAFS を測定する場合を考える。式 5.1.1 に従って求めた計算結果を表 5.1.1 に示すが、試料による吸収が大きい場合($\mu t = 4$)は 0.1%の三次光によって見かけの μt が真の 値より 0.03 も小さくなってしまう。

エッジのジャンプ $\Delta \mu t = 1$ 、試料による全吸収 $\mu t = 4$ 、高次光の割合が 0.1%のとき、高次光の 割合が 10%変化した場合の XAFS 信号 (χ)の変化を考える。下表の μ t=4 の列で、三次光の割 合が 0.1%と 0.05%の 1/5 から吸光度の変化は 0.002、エッジジャンプが 1 であるので χ の変化も 大凡 0.002 となる。これは小さな量の様に見えるが k = 12Å⁻¹付近での $k^{3}\chi$ の変化は(0.002 × 12³ =)3.5 にもなってしまう。通常の酸化物等のこの辺りでの $k^{3}\chi$ は 5 以下であるのでこれが無視で きない事が分かるであろう。逆に $\mu t = 4$ 、エッジのジャンプ $\Delta \mu t = 1$ の試料で $k^{3}\chi$ の変化を 0.2 以下に抑えるためには三次光の割合を 10⁻⁴以下にしなければならない。

ニ次半の割合	見かけ	ナの吸収係数の変化	
二次九の割古	µ t =2	µ t =3	µ t =4
0.00%	0.0000	0.0000	0.0000
0.01%	-0.0005	-0.0013	-0.0030
0.05%	-0.0028	-0.0065	-0.0151
0.10%	-0.0055	-0.0129	-0.0299
0.50%	-0.0273	-0.0630	-0.1513
1.00%	-0.0535	-0.1222	-0.2648
5.00%	-0.2427	-0.4985	-0.9109

表 5.1.1 三次光の割合が変わった時の吸収係数の真の値からの変化

7keV 程度以上の比較的高いエネルギー領域では二結晶の detuning によって高次光を取り除く ことも出来るが(4.2節参照)低いエネルギー領域では効果的でない(1.5節参照)[10,13]。従 ってミラーを用いて高次光を取り除く必要が生じて来る。 もう一つのミラーの用途は集光である。次節で述べるように物質のX線に対する屈折率は1 より僅かに小さいため、可視光域のようにレンズを用いて集光をすることは出来ない^{*}。結晶の sagittal focus を用いて集光する方法については4.6節で述べたが、エネルギー掃引すると集光 条件が変わってしまうという XAFS 実験にとっては深刻な問題があった。これを解決するのに 全反射ミラーを凹面鏡として利用する方法がある。

5.2 臨界角

物質に対するX線の複素屈折率nは

(5.2.1)
(5.2.2)
(5.2.3)

であり、 r_0 は古典的な電子半径(2.818×10⁻¹⁵m) はX線の波長、Nは単位体積中の電子数、 μ は線吸収係数である。 は 10⁻⁵から 10⁻⁶程度の正の値であるので、 n は 1 より僅かに小さく なり、適当な角度を選べば全反射を起こす。吸収を無視すると臨界角 。は

 $c = (2)^{1/2}$ (5.2.4)

となる。これらの式から分かるように重原子で構成される物質を用いた方が臨界角は大きくなり、 小さなミラーで済ませられる。このため通常は金や白金を熔融石英やフロートガラスにコートし た反射面が用いられる。しかしこれらの物質では 11~15keV 付近ある L 吸収端のため、吸収端 より高いエネルギー域で急に反射率が低下し、得られる強度が減少する。また重原子を用いると X線に対する吸収が大きいため臨界部がステップ関数的にならず幅広くなり、高次光の切れが悪 くなる。このためミラーを用いる場合は測定領域に吸収端を持たない材質を選定して用いる。ミ ラーに良く用いられる材質を表 5.2.1 に、臨界角を 7keV に設定した場合の各エネルギーのX線



図 5.2.1 各種ミラーの種々のエネ ルギーのX線に対する反射率。 照射角は表 5.2.1 に従って臨界 エネルギーを 7keV とするよう に設定した。Pt に見られる 2.15keV 付近の落ち込みは MV 吸収端、Rh における 3keV 付 近の落ち込みは L 吸収端によ るものである。

^{*}最近は屈折レンズ(これも変な用語ではあるが)と称して、屈折率の差を利用して集光する事も行われている。この場合、物質中に穴を開けた形のレンズを用いる。

<i>E</i> /eV λ/Å			<i>θ</i> c/m	rad			
	SiO ₂	Pt	Rh	Pd	Ag	Ni	
2000	6.20	16.57	42.19	33.57	32.85	30.80	29.60
2500	4.96	13.26	33.76	26.85	26.28	24.64	23.68
3000	4.13	11.05	28.13	22.38	21.90	20.54	19.73
3500	3.54	9.47	24.11	19.18	18.77	17.60	16.91
4000	3.10	8.29	21.10	16.78	16.42	15.40	14.80
4500	2.76	7.37	18.75	14.92	14.60	13.69	13.15
5000	2.48	6.63	16.88	13.43	13.14	12.32	11.84
5500	2.25	6.03	15.34	12.21	11.94	11.20	10.76
6000	2.07	5.53	14.07	11.19	10.95	10.27	9.87
6500	1.91	5.10	12.98	10.33	10.11	9.48	9.11
7000	1.77	4.74	12.06	9.59	9.38	8.80	8.46
7500	1.65	4.42	11.25	8.95	8.76	8.21	7.89
8000	1.55	4.14	10.55	8.39	8.21	7.70	7.40
8500	1.46	3.90	9.93	7.90	7.73	7.25	6.96
9000	1.38	3.68	9.38	7.46	7.30	6.85	6.58
9500	1.31	3.49	8.88	7.07	6.92	6.49	6.23
10000	1.24	3.32	8.44	6.71	6.57	6.16	5.92

表 5.2.1 石英と白金表面ミラーの臨界角

に対する反射率を図 5.2.1 に示す

先の(5.2.4)に具体的に数値を入れると、反射面が溶融石英の場合

 $[mrad] = 2.67 \cdot [Å]$

(5.2.5)

となり、7keVのX線に対する臨界角は 4.7mrad (=0.27deg)となる。簡単な計算で縦幅 2mmの ビームを受けるためには 426mm の長さのミラーが必要なことが分かる。5.2.4 式から求めた石 英と各種金属に対する臨界角の概算値を表 5.2.1 に示す。

5.3 集光ミラー

[BL-9A, 12C]

第1節に記したように、BL-9A、BL-12C ではミラーを用いてビームの集光を行っている。4.6 節に記した分光結晶を用いた sagittal 集光と比較して、ミラーを用いて集光した場合は、

- ・集光ビームサイズを小さくし易い。
- ・ 集光ビームサイズ、形状が用いる X 線のエネルギーによらず一定である。
- ある程度、高次光除去機能がある。
- ・実験者が集光の調整をする必要がない。
- といった特徴を持つ反面、

水平方向のアクセプタンスがミラーの形状によって制限され、強度を上げにくい。

- ・大きなコストが掛かる。
- ・高エネルギー側での利用や光源から遠い場所にミラーを設置することは困難。

・弯曲円筒鏡の場合、1:1 集光が最適条件であり、光学素子の配置に苦労することが多い。 という難点も持っている。

BL-12C では円筒状に研磨したミラーを弯曲させ、トロイダル面を近似している。ミラーの材 質は厚さ 50mm、長さ 1m のシリコンで、表面にはロジウムがコートしてある。水平アクセプタ ンスは設計上 2mrad であるが、ミラーの大きさの制約から実効的にはその約半分である。設計 上の照射角は 2.89 mrad、23keV 付近までの利用を想定している(モノクロメーター側の制約 から Si(111)を使う場合は約 20keV が上限である)。光源からミラーまでの距離(F1)が 20.8m、 ミラーから集光点までの距離(F2)は 10.4m で、2:1 集光になっている。実測によるとフォーカスの半値幅は 0.4mm(V)×0.65mm(H)*である。また、2:1 集光のため、角度発散はミラーのアクセプタンスの2倍になっている(最大約 4mrad)。トロイダル形状は集光条件が 1:1 の時に適用出来る近似であり、回転楕円面ミラーを用いるとより小さなフォーカスを得ることが可能である。

BL-12C の光学系での難点であった BL-7C と比べた時の強度の低さを解決するために考案し たビームラインが BL-9A である。ここでは光源から 14.21m の所にシリコン製弯曲円錐台ミラー (厚さ 70mm、長さ 1m)でビームを平行化し、分光後 17.6m 地点の U.L.E.製**弯曲円錐台ミラ ー(厚さ 70mm、長さ 1m)で集光をしている。ここでもミラー表面はロジウムでコートしてあ る。水平アクセプタンスは 3mrad ある。設計上の照射角は 4.2 mrad で、15 keV 付近までの利 用を想定している。弯曲円錐台ミラーは回転放物面ミラーの近似として使用している。この光学 系はエネルギー分解能を落とさずに大強度を得られることに特徴を持っている。実測によるとフ ォーカスの半値幅は 0.3 mm(V)×1 mm(H)である。BL-9A での集光条件は 14.21:7.70~1.8:1 で ある。BL-12C 同様に出射ビームの発散角は 1.8 倍になり、水平方向の発散は 5.4mrad になる。

これらのミラーはビームタイム初めに調整を行っており、通常実験者がこれらのミラーを調整 する必要はない。

5.4 高次光除去用ミラー

[BL-7C, 9A]

[BL-7C]

BL-7C と 9A には 7keV 程度以下の低エネルギー域でも信頼出来る XAFS スペクトルを得られるように高次光除去用の二枚組ミラーが設置されている。

5.4.1 BL-7C**の高次光除去用ミラー** (focusing double mirror)

BL-7C に設置されたミラーは図 5.4.1 に示すように二枚の平行に配置した平面ミラーから構成 されている。ミラーは各々全長 700mm の溶融石英製でコーティングは施していない。7keV の X線に対する熔融石英と白金の反射率(R)と三次光と一次光の反射率の比(R_3 / R_1)を吸収の効果 を含めて計算し、図 5.4.2 に示した。この図からも分かるように、三次光と一次光の反射率の比 (R_3 / R_1)は石英製ミラーの方が小さくかつこの条件での反射率も高い。

調整の自由度としては上流側の上下動(Z_1)、下流側の上下動(Z_2)、二枚のミラーの間隔(D)、 二枚のミラーの水平方向(光軸方向)の距離(t)、第一ミラーの弯曲(B)の五つがある。 Z_1 、



図 5.4.1 BL-7C に設置された focusing double mirror の自由度と 1パルス当たりの送り量。

 ^{1.7}節に記したKEK Report出版当時は0.6mm(V)×1.3mm(H)であったが、光源の高輝度化、調整技術の
 進歩により上記の値まで小さくできた。

^{**} Corning社の販売している熱膨張率の小さなガラスの商標名。



図 5.4.2 石英製、白金製ミラーの一次光に対する反射率(R1)と三次光除去率(R3/R1)。 cは 2.2.4 式から求めた臨界角。X線のエネルギーは 7keV。

Z₂ は二枚のミラーの高さと、照射角を調整し、他の三つの自由度は Z₁、Z₂ で調整される定盤の 上に載っている。通常は t と B には触れないので、Z₁、Z₂、D の三つのパラメーターのみで調 整することになる。<u>不用意に B をいじるとミラーを割るので触らないこと</u>。通常 B は使用禁止 となっているが、実験上弯曲する必要がある場合は連絡を頂ければ解除する。弯曲(B)以外の ミラーの調整は 5.5 節に記すソフトウェアを用いて行うことを勧める。

通常、二枚のミラーは各々の半部ずつが重なる様に(*t* = 350mm)設置されている。この場合、 幾何学的に明らかなように、

$$D = t \tan \theta$$

(5.4.1)

の関係が成り立ち、cut-off を 6.5keV に設定すると、表 5.2.1 から θ = 5.1 mrad となり D = 1.79mm となる。 より浅い角度ではより小さな面間隔となるので取り扱い上注意が必要である。

上記の各自由度には5相パルスモーターが接続されており、真空外から制御出来る。各自由度 にはポテンショメーターが付いていて、位置を読みとることが出来る。Bの動きは真空槽内のダ イヤルゲージでも読める。これらの1パルス当りの移動量と方向を図 5.4.1 及び表 5.5.1 に示す。 またミラー槽の出入口には蛍光板が設置されていてビームの位置、形状を観測出来る。更にミ





7keV 付近より高いエネルギー域では A、それ以下では B のモードをを通常使 用する。C は特に低エネルギー域を狙う 場合、D は光軸の方向を変えたい場合に 使用するモードである。

ラーの上流側端面及び下流側端の反射面にも蛍光物質が塗布してあり、これらの部分にビームが 当たると目視出来る。

このミラーは図 5.4.3 に示す四つのモードをとることが出来る。A は通常のミラーを使用しな いモードで、ミラーの間隔は最大付近(約 13mm)で水平に配置され、X線ビームは二枚のミ ラーの間を通り抜けて行く。B は通常のミラーを用いるモードで、用いるX線のエネルギーに応 じた角度、間隔で設定され、二回反射されたX線はほぼ入射光と平行に進んで行く。C は特に低 いエネルギーのX線を用いる場合に使えるように考えたもので、四回の反射によって高次光をよ り良く取り除くものである。D は第一ミラーのみを使用して、X線の進む方向を斜め下方に向 ける場合に利用出来る。これは液面でのX線の全反射を利用する実験等に有用である。これまで の経験では E > 7keV で A、E < 7keV で B のモードを使うのが好ましい。

第一ミラーを鉛直方向に弯曲して集光目的に利用することも可能ではあるが、付加機能として 設計されたため、集光目的のミラー程良い集光は得られない。

5.4.2 BL-9Aの高次光除去用ミラー

[BL-9A]

BL-9A に設置されたミラーも BL-7C のものと同様の構造をしている。ただ、BL-7C とは逆に

第一ミラーは上向きにビームを反射する構造となっており、弯曲機構は付随していない。ミラー は全長 300mm の溶融石英で、表面はロジウムとニッケルでそれぞれ幅 40mm のストライプ状 にコートされている。これは、BL-9A で使用するエネルギー範囲の中にロジウムのL吸収端(3.0、 3.1、3.4 keV)及びニッケルの K 吸収端(8.3keV)が存在するためで、目的とするエネルギーに応 じてミラーを水平移動して反射面を切り替えて用いる。通常はニッケル面側で使用する。

調整の自由度としては上流側の上下(Z_1)、下流側の上下(Z_2)、二枚のミラーの間隔(d)及 び反射面の選択(光軸直交方向への動き)(x)の四つがある。 Z_1 、 Z_2 は二枚のミラーの高さと、 入射角を調整し、他の二つの自由度は Z_1 、 Z_2 で調整される定盤の上に載っている。BL-7C の場 合と異なり、t、Bの自由度はない。二枚のミラーは各々の半部ずつが重なる様に(t = 150mm) 設置されている。この場合、(5.4.1)式から明らかなように、cut-off を 6.5keV に設定すると、表 5.2.1 からニッケル面では $\theta = 9.1$ mrad となり D = 1.37mm となる。

上記の各自由度にはパルスモーターが接続されており、真空外から制御出来る。四つの自由度 についてはスケールが付いており、現場で位置を読みとることが出来る。これらの1パルス当り の移動量と方向を図 5.4.4 及び表 5.5.2 に示す。



またミラー槽の出入口には蛍光板が設置されていてビームの位置、形状を観測出来る。

図 5.4.4 BL-9A の高次光除 去用ミラーの自由度。この 他に紙面に垂直な方向の自 由度(x)があり、反射面の切 り替えに使用する。

5.5 ミラーの制御系

集光用ミラーをユーザーが調整する必要はないので、ここでは高次光除去用ミラーの調整についてのみ記す。 集光用ミラーを調整する必要がある場合はステーション担当者と連絡をとること。

5.5.1 BL-7Cの高次光除去用ミラー制御系

[BL-7C]

ミラーの姿勢は 16CH パルスモーターコントローラー(ツジ電子 PM16C-02)と 8CH ポジションモニター(ツジ電子 8PMON-01)を用いて制御される。パルスモーターコントローラーからパルスを送ることによって各軸は動き、この動きに対応してポテンショメーターの読みも変化する。各軸にはリミットスイッチが設定されていて、リミットを叩くとモーターは緊急停止する。またポテンショメーターの読みはポジションモニターの中でアナログコンパレートされ、これもリミット情報となる。但しリミットスイッチを叩くとパルス数と位置の関係にずれが生じるのでむやみに動かさないこと。各軸とコントローラー等のチャンネルの対応は表 5.5.1 に示してある。

PM16C-02 は高いコストパフォーマンスを持った機種であるがやや使い方が難しいので、通常は備え付けのソフト FDMC を用いて制御する。開発した時代が 1980 年代と古いため、パソコンと PM16C-02 の間はパラレルインタフェースで接続されている。このため、ノイズがのると

誤動作する事があるので、調整終了後は、表示されるチャンネルを0と1にし、PM16C-02をMANU モードに設定すること。なお、制御ソフト FDMC を使用した場合は正常に終了すると、使用し ていないチャンネル(0と1)に切り替えて終了し、誤動作による被害を防いでいる。

		12 J.J.I	ロ軸とノャノネルの	יטי <i>ו</i> ניא <i>ר</i>
軸	PM16C-02	8PMON-01	移動量	備考
Z_1	Ch 3	Ch 3	0.1 μm/pulse	CWで上、CCWで下
Z_2	Ch 4	Ch 4	0.1 μm/pulse	CW で上、CCW で下
t	Ch 5	Ch 5	1 μm/pulse	
D	Ch 6	Ch 6	46512 pulse/mm	CCW で第ニミラーが近付く
В	Ch 7	Ch 7	0.001 µm/pulse	無断使用禁止 、CW で上に凸

表 5.5.1 各軸とチャンネルの対応

5.5.2 8CHポジションモニター (ツジ電子8PMON-01)

BL-7C でミラーの位置読み取りに用いる。この読みを予め設定 した値とアナログコンパレートし、PM16C-02 のリミット信号 としている。

1) CH.SELECT SW を希望の CH に合わせて位置を読み取る。

2) A.LIMIT (Analog Limit)設定内容を見たい時は CH セレク ト後見たい方向の A. LIMIT ADJ SW を押して読み取る。

・ユーザーはリミットの設定を変更してはならない。

・電源投入後ポテンショメーターが昇温するため多少表示が変化 することがあるので注意すること。



BL-7C で focusing double mirror の制御に用いているパルスモーターコントローラーである。

1.概要

1)特徴、制御の概念

PM16C-02 には 3 個のマイクロコンピュータ(全体を制御する CPU 1 個とパルスモーター コントロール用の CPU が 2 個)が内蔵されている。2 個のパルスモーターコントロール用 CPU(A,B)と 16 台の外部モーター(0~F)との接続を切り替えて制御を行なっている。従って CPU とモーターの接続が決められた後は外部から個々のモーターは見えず、A,B の CPU の みが見える。

現在位置、速度、立ち上がり、立ち下がりレート等はバッテリーバックアップされたメモ リに保存されていて必要な時に読み出される。ユーザーはこれらのパラメーターを変更して はならない。

2)使用法

下部の FUNCTION SW の機能は以下の通り。

[CPU/MANU]:制御モードの切り替え、押す毎に切り替わる。

CPU(MODE SET):計算機制御モード

MANU :手動運転モード

[STOP]:モーターの停止。手動運転時は選択されているモーターの停止。 EM: 緊急停止。モーターは脱調しパルス数と位置の対応は狂う。 SLOW:減速停止。通常の停止



図 5.5.1 BL-7Cの 8PMON-01(上)と PM16C-02(下)

[INDEX]:インデックスに従って台形駆動する。

ABS:絶対インデックス(サムホイール SW で指定された位置へ行く)

REL:相対インデックス(サムホイール SW で指定されたパルス数相対移動する)

どちらも符号は DIR&POL で設定する。

[RUN]:インデックスによらず歩進する。

HP STOP: サポートしてない

PB STOP: STOP ボタンを押すまで歩進を続ける

[DIR&POL]: 歩進方向やデータの符号を決める

[PRESET]: 使用禁止

INDX:サムホイール SW のデータをカウンタにプリセットする。ユーザーは使用禁止。

COND:個々のモーターの特性を設定する。ユーザーは使用禁止。

[手順]

1. CH SEL でモーターを選択

2. SET DATA サムホイール SW を目的の位置(絶対移動) または移動量(相対移動)に合わ せる

- 3. CPU/MANU を MODE SET 側に設定
- 4. DIR&POL で SET DATA の符号を設定する
- 5. INDEX を ABS/REL (絶対 / 相対移動)に合わせる
- 6. その他の設定は STOP(SLOW), RUN(PB STOP), PRESET(INDX), SPEED(M)
- 7. CPU/MANUをMANU側に設定する。
- 8. 動作させる CPU (A,AB,B) を CONTROL SW で選択し、INDEX を押すと歩進する。AB を選択すると A、B で選択された二軸が同時に動く。

5.5.4 BL-7Cの高次光除去用ミラーの調整

[BL-7C]

 ルール(以下の事を厳守すること)
 ・調整を開始する前に、現在の値(PM16C-02、8PM0N-01、PM4C-05)を log book に記録すること。
 ・モーターを動かしたときは、1 操作終了毎に PM16C-02 の当該チャンネルのパ ルス数の読みと 8PM0N-01 の当該チャンネルの読みを記録すること。

・使用後はミラーを使わないモード(図 5.4.3 の A)に戻すこと。この時、ミラ ーは水平状態にある。

ここでは通常行われる調整手順について記す。誤操作を防ぐために、ミラーの弯曲以外の基本的 な操作は制御用パソコンからソフトウェア FDMC を使用して行うことを原則とする。まず、こ のソフトウェアについて簡単に記す。このソフトは PM16C-02 の複雑な操作による事故を回避 するためのものであり、自動設定ではない。またこの場合も各調整操作終了毎にパルス数と 8PMON-01 の読みを log book に記録すること。各調整操作の記録は異常動作や誤操作の検証に役 立つほか、次回に再設定する場合にも役立つ。操作手順は以下の通り。

まず、PM16C-02 の CPU/MANU スイッチを MANU 側に設定し、Ch3~7 の値と 8PMON-01 の Ch3~7 の値を log book に記録する。また、電動昇降ステージの位置(PM4C-05 の Ch C)の値 及び現在の Bragg 角も記録する。PM16C-02 の CPU/MANU スイッチを CPU(MODE SET)側 に設定し、FDMC を起動する。

A:¥USER> FDMC

- : (省略)
- SELECT MODE
- 1-- HEIGHT 2-- TILT 3-- Z1,Z2 ABSOLUTE MOVE
- 4-- DISTANCE 5-- STOP 6-- END

ここで

- 1: ミラーの高さの調節(入力単位 mm)。+で上、-で下へ動く。
- 2: ミラーの傾き(照射角)の調節(入力単位 mrad)。+で照射角大、-で照射角小。
- 3: Z1, Z2 のパルス数による制御。初期値に戻す等の場合に用いる(入力単位 パルス数)。
- 4: 二枚のミラー間隔の調整(入力単位 パルス数)。+で間隔大、-で間隔小。
- 5: モーターの停止
- 6: プログラムの終了

に用いる。以下、必要なモードを選択し、必要なパラメータを入力する。

ミラーを入れる調整手順は

- 1. ミラーを入れない状態で光学系、検出系を最適化し、強度を記録する。この時の Bragg 角は 目的とする測定範囲の最もエネルギーの高い所に設定する。また、高次光の割合を抑制する ため、通常は I₀を最大強度の 60%程度に detune した状態とする。
- 2. TILT モードでミラーを(計算から求めた)所定の角度に設定する。なお、暴走を防ぐため、 一回当たりの角度変化は 5mrad 以内に制限されている。
- 3. HEIGHT モードでミラーの高さを下げる(BL-9A では上げる)。入射ビームがミラーに当たるとI₀用電離箱には入射しなくなるので、I₀の強度が下がる。また、第一ミラー上流側端面、下流側反射面に塗ってある蛍光体の光り方を見ながら入射ビームが第一ミラーの中央に当たるように合わせる。この時ミラー下流の蛍光板を見ているとダイレクトビーム ダイレクトビーム+1回反射ビーム 1回反射ビームと変化していくのが分かる。HEIGHT も一回当たりの変化は 5mm 以内に制限されている。BL-7C のミラーは 700mm あるので、通常は全てのビームを受けられるが、浅い角度で使用する場合は、ミラーで受けきれないことがある。この場合はミラー前のスリットで不要なビームを切る(切る前後のマイクロヘッドの読みをlog book に記録する)。
- 同じ蛍光板を見ながら、DISTANCE を用いて1回反射ビーム 1回反射ビーム+2回反射 ビーム 2回反射ビームと像が変化するように二枚のミラーの間隔を調整する。 DISTANCE は到着予定位置のパルス数を入力する。この値は log book で以前の調整を参照 して決める。間隔は極めて小さいので二枚のミラーをぶつけないように注意すること。
- 5. 蛍光板を除き、ハッチ内の電動昇降ステージの高さを調節する。
- 強度を見ながらミラーの傾斜角を最終的に調整する。概ねミラー以外は同じ条件で、ミラーの無い時の 60~80%程度の強度になるように設定すると適当である。または I₀前のスリットの上流に基本波の殆どを吸収する程度のアルミ箔を入れても、アルミ箔が無い時とμt が変わらない様に照射角を調整する。
- 7. 最大強度となるように二結晶の平行性を合わせる。
- 8. END でプログラムを終了する。終了すると PM16C-02 には Ch0 と 1 が選択されているはず である。
- 9. ミラーの調整が終了したら、PM16C-02 を CPU モードから MANU モードに戻す。

実験終了後はミラーを抜いて、図 5.4.3 の A のモードに戻すが、この手順は

- 1. FDMC を起動し、DISTANCE を元の位置に戻す。
- 2. Z1、Z2 を初期値に戻す。
- 3. FDMC を終了する。
- 4. ミラー前のスリットを動かした場合は元に戻す。
- この場合も、ミラー設定時同様に log book に記録する。

5.5.5 BL-9Aの高次光除去用ミラーの制御系

[BL-9A]

ミラーの姿勢は 16CH パルスモーターコントローラー(ツジ電子 PM16C-02N)を用いて制 御される。各軸の絶対位置はミラー駆動機構の各軸のスケールで読める。各軸にはリミットスイ ッチが設定されていて、リミットを叩くとモーターは緊急停止する。但し**リミットスイッチを 叩くとパルス数と位置の関係にずれが生じるのでむやみに動かさないこと。**各軸とコントロー ラー等のチャンネルの対応は表 5.5.2 に示してある。

PM16C-02N は高いコストパフォーマンスを持った機種であるがやや使い方が難しい。また、 BL-9C では PM16C-02N の他のチャンネルをコリメーションミラー、集光ミラーの制御に用い ているので、通常は備え付けのソフト MIRC2 を用いて制御する。安全のため BL-7C 同様に調整 終了後は PM16C-02N を LOCAL モードに設定することを推奨する。

表 5.5.2 各軸とチャンネルの対応

軸	PM16C- 02N	移動量	備考
Z_1	Ch A	0.025 µm/pulse	CW で上、CCW で下
Z_2	Ch B	0.025 µm/pulse	CW で上、CCW で下
Х	Ch C	0.1 μ m/pulse	CW で BL-8 側へ、CCW で BL- 10 側へ
d	Ch D	0.08 µm/pulse	CW で間隔大、CCW で間隔小

5.5.6 BL-9Aの高次光除去用ミラーの調整

[BL-9A]

ルール(以下の事を厳守すること)
・調整を開始する前に、現在の値(PM16C-02N、PM4C-05)を log book に記録す
ること。
・モーターを動かしたときは、1 操作終了毎に PM16C-02N の当該チャンネルのパ
ルス数の読みを記録すること。
・使用後はミラーを使わないモード(図 5.4.3 の A 相当)に戻すこと。この時、
ミラーは基本光軸に平行にある。

誤操作を防ぐために、基本的な操作は制御用パソコンからソフトウェア MIRC2 を使用して行うことを原則とする。このソフトウェアについて簡単に記す。このソフトは PM16C-02N の複雑な操作による事故を回避するためのものであり、自動設定ではない。またこの場合も各操作終了毎にパルス数の読みを log book に記録すること。各調整操作の記録は異常動作や誤操作の検証に役立つほか、次回に再設定する場合にも役立つ。操作手順は以下の通り。

まず、PM16C-02N の REMT(remote)/LOCL(local)スイッチを LOCL 側に設定し、ChA~D の値を log book に記録する。また、電動昇降ステージの位置(PM4C-05 の Ch C)の値及び現在

の Bragg 角も記録する。次に、PM16C-02N の REMT/LOCL スイッチを REMT 側に設定し、 MIRC2 を起動する。

A:¥USER> MIRC2 : (省略) SELECT MODE 1-- HEIGHT 2-- TILT 3-- Z1,Z2 ABSOLUTE MOVE 4-- DISTANCE 5-- STOP 6-- END

ここで

- 1: ミラーの高さの調節(入力単位 mm)。+で上、-で下へ動く。
- 2: ミラーの傾き(照射角)の調節(入力単位 mrad)。+で照射角大、-で照射角小。
- 3: Z1, Z2 のパルス数による制御。初期値に戻す等の場合に用いる(入力単位 パルス数)。
- 4: 二枚のミラーの間隔の調整 (入力単位 mm)。 + で間隔大、 で間隔小。
- 5: モーターの停止
- 6: プログラムの終了
- に用いる。以下、必要なモードを選択し、必要なパラメータを入力する。 以下調整手順については 5.5.4 節を参照。

5.6 測定例

測定例として 5 μm のチタン箔と適当な厚さのアルミニウム箔を重ねたものを取り上げる。二結晶の tune を最大強度に合わせた場合はアルミニウム箔の厚さが 30 μm であっても高次光のため図 5.6.1 の左側の図を見れば一目瞭然の様にまともなスペクトルを測定することは出来ない(Ti:Al=1:3.6(重量比)=1:6.4(原子数比))。

次に 5 µm のチタン箔と 60 µm のアルミニウム箔を重ねた例を中央の欄に示す。この測定では I₀の強度が最大値の 60 %程度になるように二結晶の tune を調節(detune)している。一番上の生 データではプリエッジのバックグラウンドが上に凸になることからデータの異常が分かるが、そ れ以外の点はグリッチが大きい等の目立った問題点は無い。またプリエッジが上に凸になること もデータをプロットし、注意深く観察する事によってやっと気付く程度である。 $k^3\chi(k)$ やそのフ ーリエ変換の絶対値を見ても特に異常は観測されない。ここで k=6 Å⁻¹付近の $k^3\chi(k)$ の山の値が 15.43、フーリエ変換の主ピークの高さが 21.76 であることを記憶にとどめて頂きたい。従って 余程注意をしていないと、detune によって信頼できるスペクトルが得られると結論してしまうで あろう。

最後に同じ試料(5 µm のチタン箔と60 µm アルミニウム箔を重ねたもの)を、二結晶の tune は最大に合わせ、BL-7C の focusing double mirror を用いて高次光を除去した光学系で測定した 例を右側に示す。まずプリエッジが下に凸で正常である事が分る。 $k^3\chi(k)$ やそのフーリエ変換の 絶対値を見ても先と同様特に異常は観測されない。ここで k=6 Å⁻¹付近の $k^3\chi(k)$ の山の値を見る と 17.06、フーリエ変換の主ピークの高さは 25.68 である。このことより先の detuning ではまだ 充分に高次光が取り除かれていないことが分る。同じセットアップでチタン箔のみを測定した場 合は各々 17.06, 24.78 でありミラーを用いた場合は正しい測定結果を示していることが分る。



第6節 各ビームラインの構成

第1節で各ビームラインの概要については触れたが、より詳しく各ビームラインの特徴、調整 法について建設の年代順に記す。詳しい構成、性能については 1.7 節に記した文献を参照頂きた い。

6.1 BL-10B

PF の中でも最古のビームラインの一つであり、1982 年の運転開始以来 XAFS 専用ラインとして使用されている。BL-10B の特徴をまとめると以下の様になる。

Si(311) channel-cut モノクロメーターを使用しており、エネルギー分解能が高い。 光学系の調整が殆ど不要

集光系がなく、Si(311)を使用しているため、X線強度は他のラインと比較して低い。

モノクロメーターにロータリーエンコーダーが付いていないため Bragg 角に注意を払うことが必要。

実験ハッチが小さい。

高次光除去用ミラーシステムがなく、6keV 以下での実験は困難(小型ミラーをハッチ内 に設置して対応する必要がある)。 表 6.1.1 BL-10B で Si(311) channel-cut

の割合。

E/keV

6.6 7.6

9.0

11.1

14.6

21.8

モノクロメーターを用いた時の高次光

高次光の割合

 1.3×10^{-2}

 1.5×10^{-3}

 7.1×10^{-4}

 1.7×10^{-4}

 0.5×10^{-4}

 $< 1.8 \times 10^{-5}$

ビームラインの構成を図 6.1.1 に示す。得られる光子 束については図 1.5.1 参照のこと。表 6.1.1 に記される ように低エネルギー域で高次光の割合が大きい。

上述した様に、殆ど調整の必要はないが、BL-10B で のエネルギー分解能は I₀ 用電離箱の前に設置したスリ ットの鉛直方向の開口が決めている。通常は 1mm 程度 に設定されているが、特に高いエネルギー分解能を必要 とする場合はこの幅を狭くすると改善される(図 6.1.2

参照)。このスリットの横幅は試料の大きさとの関係で決めれば良いが、通常は 5~10mm 程度 で利用されている。4.4 節に記した様にチャンネルカット分光器では角度掃引に伴って出射X線



図 6.1.1 BL-10Bの構成図。

ビームの高さが変わる。XAFS 実験用制御ソフ ト BL10B01 を用いている限り、実験ハッチ内 のステージは 4.4.1 式に従ってビーム高の変化 に追随する。ただし、大きく角度を変えた時は ステージの高さを調整し、最大強度の場所に合 わせる必要がある。このためには以下の様に操 作する。

- 1. パルスモーターコントローラー IPM2C-01 の設定を LOCAL、A、SCAN または SS とする。
- CW/CCW のどちらかを選択し、START を 押しては、直ちに STOP を押すことを繰 り返しながら、最大強度となる点を探す。 SS を選択した場合は START を押す毎に 1パルス送られるので、STOP を押す必要 はない。



図 $6.1.2 I_0$ 前スリットの開口高さを変えた時の K_2 MoO₄の XANES。

IPM2C-01 は 1980 年代前半に開発されたもので、最近のパルスモーターコントローラーとは異なり、パルス数のカウントはバックアップされておらず、また負の値は表示できず、0-1 は 9999999 となる。その他の仕様を表 6.1.2 に記す。

$1.3m(W) \times 2.5m(L) \times 2.5m(H)$
$2.37m(W) \times 2.4m(H)$
1000mm(W)×1800mm(L) 天板はアルミ
電動昇降ステージ上面から 348mm、オプティカ
ルベンチ上面から 188mm。
シグマ光機製 大型アルミ光学ベンチ Σ-01
あり(ハッチ上流側)
実験八ッチ背面(BL-11 側)
実験ハッチ背面(BL-11 側)、BL-10 下流実験ホー
ル外周部

表 6.1.2 BL-10B の主要な仕様

1) L は光軸方向、W は光軸直交方向、H は高さ

6.2 BL-7C

BL-10B に次いで 1985 年に建設されたビームラインである。BL-7C の特徴をまとめると以下の 様になる。

Si(111)サジタル集光型二結晶モノクロメーターを使用しているため大強度が得られる。 モノクロメーターにローターリーエンコーダーが付いているため、角度を見失いにくい。 focusing double mirror を利用すると、低エネルギー域でも高次光を無視できる。 電動昇降ステージ上が殆どフリーで、特殊なセットアップを組み易い。 実験八ッチが広い。

サジタル集光の調整がやや面倒。

ハッチ外の空間が狭い。

ビームラインの構成は図 1.2.1 を、光子束については図 1.5.1、高次光の割合に付いては表 1.5.1 を参照のこと。 電動昇降ステージの高さの調整はパルスモーターコントローラー PM4C-05 の C チャンネルを 使用して行う。方法は、

- 1. LOC/REM を LOCal モードにする。
- C チャンネルのランプだけを点灯させる。A, B, D が点灯している時はそのボタンを押して 消灯する。
- 3. スピードを L とし、緑のスイッチを上げ下げすると、ステージが上下する。

その他の仕様を表 6.2.1 に記す。

表 6.2.1 BL-7C の主要な仕様

実験ハッチ寸法 ¹⁾	$2.1 \text{m(W)} \times 3 \text{m(L)} \times 2.5 \text{m(H)}$
搬入扉寸法	$1.3m(W) \times 2.4m(H)$
電動昇降ステージ寸法 ¹⁾	1000mm(W)×1200mm(L) 耐荷重 150kg
	天板は着磁性ステンレス
光軸位置	電動昇降ステージ上面から 348mm、オプティカ
	ルベンチ上面から 188mm。
オプティカルベンチ	シグマ光機製 大型アルミ光学ベンチ Σ-01
有害ガス用排気ダクト	あり(ハッチ下流側)
検出器用ガス	実験ハッチ屋根上
その他の器具保管場所	BL-5 下流実験ホール外周部(化学洗浄室入口脇)

1) L は光軸方向、W は光軸直交方向、H は高さ

6.3 BL-12C

既に廃止された BL-6B に次いで 1994 年に建設されたビームラインである。従来のサジタル 集光に替えて、弯曲円筒面ミラーでビームを集光している。BL-12C の特徴をまとめると以下の ようになる。

Si(111)二結晶モノクロメーターを使用し、集光ミラーがあるため大強度を得られる。 モノクロメーターにローターリーエンコーダーが付いているため、角度を見失いにくい。 弯曲円筒面ミラーで集光をするため、フォーカスが小さく、エネルギーを変えても変化し ない。

実験ハッチが広い。

実験ハッチ外の空間も広い。

多素子半導体検出器を備えており、低濃度試料、薄膜試料の蛍光 XAFS 実験が可能。

得られる全強度は BL-7C よりも低い。

高次光除去用ミラーシステムが無いため 5keV 以下での実験は困難(小型ミラーをハッチ内に設置して対応する必要がある)。

出射ビーム光軸は水平でない。

ビームラインの構成を図 6.3.1 に示す。この図に示されるように、ビームは水平に対して 2.89 mrad × 2 = 5.78 mrad = 0.33°上昇して来る。このため、電動昇降ステージもこの分だけ傾けて ある。得られる光子束については図 1.5.1、高次光の割合は図 6.3.2 に記した。

BL-12C のエネルギー分解能はモノクロメーターと集光ミラーの間に設置されているスリット (Slit-2、ミラー前スリット)の鉛直方向の開口で決まる。当然ながら、この開口を大きくする と強度は増大するがエネルギー分解能が下がり、逆に開口を小さくするとこの逆になる。得られ たX線光子束とエネルギー分解能の関係を金属銅箔の XANES スペクトルを例にして図 6.3.3 に 示す。電動昇降ステージの操作は BL-7C と同じ。

実験ハッチ寸法 ¹⁾	$2.2m(W) \times 3m(L) \times 2.8m(H)$
搬入扉寸法	$2m(W) \times 2.45m(H)$
電動昇降ステージ寸法 ¹⁾	1000mm(W)×1500mm(L) 耐荷重 200kg
	天板は着磁性ステンレス
光軸位置	電動昇降ステージ上面から 348mm、オプティカ
	ルベンチ上面から 188mm。
オプティカルベンチ	シグマ光機製 大型アルミ光学ベンチ Σ-01
有害ガス用排気ダクト	あり(ハッチ上流側)
検出器用ガス	実験ハッチ手前 (BL-13 側)及びハッチ上流側
その他の器具保管場所	BL-12 下流戸棚

表 6.3.1 BL-12C の主要な仕様

1) L は光軸方向、W は光軸直交方向、H は高さ







図 6.3.2 BL-12C における高 次光の割合。 :最大強度 tune 時、 :最大強度の 60%に tune し た時 6.4 BL-9A

BL-9A は BL-7C 以上の強度を BL-12C 並の使い勝手で実現することを目指して 1999 年までに建設されたビームラインで ある。BL-9A の特徴をまとめると以下の ようになる。

> Si(111)二結晶モノクロメーターを使 用しているため大強度が得られる。 弯曲円錐台ミラーを用いてビームを 平行化するためエネルギー分解能を 犠牲にせずに大強度を得られる。

> モノクロメーターにローターリーエ ンコーダーが付いているため、角度 を見失いにくい。

弯曲円錐台ミラーで集光をするため、 フォーカスが小さく、エネルギーを 変えても変化しない。

高次光除去用ミラーシステムがある ため 4keV 以下のエネルギー域でも 高次光の割合が無視しうる。

光子密度が高いため、電離箱で使用 するガスの種類が他のラインと異な る。

光子密度が高いため、試料のX線照 射による変性、損傷が観測されるこ とがある。

出射ビーム光軸は水平でない。

図 6.4.1 の構成図に示されるように、 BL-9A では弯曲円錐台ミラーで入射X線 ビームを平行化した後に二結晶分光器で分 光し、再度弯曲円錐台ミラーで集光してい る。弯曲円錐台ミラーはここでは回転放物 面の近似として用いている。このビームラ



図 6.3.3 Slit-2(ミラー前スリット)の開口 を変えたときに BL-12C で得られる銅箔の XANES。 (a) 7.2×10¹⁰ s⁻¹、(b) 4.8×10¹⁰ s⁻¹、(c) 6.4×10⁹ s⁻¹。光子束は蓄積電流 300mA に規格化してある。



図 6.4.1 BL-9A の構成図。

インでの出射ビームは 4.2×4 = 16.8 mrad = 0.96°下向きに傾いており、ビーム高も他のライ ンより低い。得られる光子束については図 1.5.1 参照のこと。高次光の割合を図 6.4.2 に記す。 軟 X 線領域の実験を行うため、Be 窓の厚さが他のラインより薄いので破らない様に注意が必要 である。

BL-9 のエネルギー分解能はミラーの形状と分光結晶の rocking curve 幅で決まっており、実験者が制御する部分はない。BL-9A では図 6.4.3 に示すように、BL-12C と比較して高いエネル ギー分解能と図 1.5.1 に示したように高い強度を同時に得ることが出来る。

その他の仕様を表 6.4.1 に記す。

表 6.4.1 BL-9A の主要な仕様 実験ハッチ寸法 ¹⁾ 変形しているが、最大寸は $2.8m(W) \times 2.6m(L) \times 2.5m(H)$ 搬入扉寸法 $1.88m(W) \times 2.39m(H)$ 電動昇降ステージ寸法¹⁾ 1000mm(W)×1500mm(L) 耐荷重 150kg 天板は着磁性ステンレス 光軸位置 電動昇降ステージ上面から 348mm、オプティカ ルベンチ上面から188mm。 オプティカルベンチ シグマ光機製 大型アルミ光学ベンチ Σ-01 有害ガス用排気ダクト あり 検出器用ガス 実験ハッチ下流側 その他の器具保管場所 なし(主に BL-7C と共用)

1) L は光軸方向、W は光軸直交方向、H は高さ



図 6.4.2 BL-9A で得られるビーム 中の高次光の割合。最大強度を得 るように調整()、強度が 60% となるように detune()、) ミラーを利用()、)。三角は 高次光割合を実験的に決められ ず、この値以下であることを示 す。

> 図 6.4.3 BL-9A で測定され た金属銅箔の XANES。こ の時の強度は蓄積電流 300mA 時に換算して 3.9× 10¹¹s⁻¹であり、同じ程度の 分解能を示す図 6.3.3 の(c) と比較すると約 60 倍の強 度である。

59

第7節 XAFS実験

7.1 計測系

初期設定を行った後、実験中の機器はパーソ ナルコンピューターで制御される。図 7.1.1 に モノクロメーター制御を含めた信号処理、制御 系のブロック図を示した。BL-7C、9A、12C で はスペクトルの最初の点で計算上のモノクロメ ーターの Bragg 角とエンコーダーの読み取り 値とを照合し、有意のずれがあれば補正する。 2点目以降についてはエンコーダーの読みを用 いた補正は行っていない。通常は二結晶の平行 性についても特に補正を行っていないが、 Si(311)結晶を用いて約 20keV 以上のエネルギ -域での測定を行う場合はピエゾ素子を用いて 二結晶の平行性を制御することが出来る。BL-10B の場合はエンコーダーが無いので、パルス 数のみを基準にして制御し、同時にステージの 高さも制御している(図 6.1.1)。



図 7.1.1 BL-12C の制御系。BL-7C、9A も基 本は同様である。

電離箱に入射したX線はその中の気体を電離する。電離箱の一方の電極には積層乾電池(また は応用光研 714-1C 高圧電源等)によって数百~2kVの電圧がかけられ、電離によって出来た電 子を補集する。他方の電極にはイオンが補集され電流信号となって電流増幅器(Keithley 427、 Ithaco 1211 または DL Instruments 1211)に入り、電圧信号に変換される。電流増幅器の信号の立 ち上がり時間はノイズを抑えながら十分な応答速度を得るため通常 100ms 程度に設定してある。

変換された電圧信号は Voltage to frequency (V/F)コンバーター(ツジ電子 NVF-02B)でパルス 列に変換される(10V の入力に対して 1 MHz の出力が得られる)。V/F コンバーター内部には ノイズ低減のため $f_c=16$ Hz の low pass filter が組み込まれている。A/D コンバーターを用いずに V/F コンバーターを用いる主な目的は信号の時間積分を可能としてデータの質を良くする事にあ る。これと同時に電離箱の出力を示す電圧信号はディジタルパネルメーターに表示され、I₀とI か ら μ t が求められ表示される(アナログ演算であるのであくまでも目安である)。

パルス信号はスケーラー(ORTEC 974 Quad Counter/Timer)でカウントされる。このスケーラ ーは1chのタイマーと3chのスケーラーを持っており、有効桁数は8桁であるので、通常オー バーフローすることは無い。スケーラーは所定の時間データーを蓄積した後、マイクロコンピュ ーターにデータを転送する。マイクロコンピューターはそのデータをメモリーに保存し、CRT に出力する。1スペクトルの測定が終る毎にデータはディスクにセーブされる。またリングの蓄 積電流値も直接マイクロコンピューターに入力される。このスケーラーはマイクロコンピュータ ーの指令に従って動作するのでユーザーが直接触れる必要はない。

7.2 電離箱

7.2.1 電離箱の構造と動作原理

電離箱は I_0 計測の他、透過法での I、蛍光法では I_F の計測等に利用されており、電離箱を正 しく使用できるかどうかは XAFS 実験の成否を決めると言っても過言ではない。電離箱は図 7.2.1



図 7.2.1 平行平板型電離 箱の構造。

に示すように単純な構造をしている。二枚の平行配置された電極の間にX線が入射するとそこに あるガスを電離し、その電荷を捕集して入射X線量を知ることが出来る。

$$s = \frac{\alpha Ee}{W} I$$

ここで s は信号電流(A)、 α はガスによる X 線の吸収率、E は入射 X 線のエネルギー(eV)、e は単位電荷(1.6×10⁻¹⁹ C)、W は気体を電離するのに期待されるエネルギー(25~30eV)、I は 1 秒当たりの入射光子数である。 $I = 10^{10}$ photons/s、E = 8000eV、 $\alpha = 0.2$ とすると、 $s = 8.5 \times 10^{-8}$ A になる。

電離箱取扱上の注意点は

- ・ガス配管の接続、窓等からガス漏れを起こさない。
- ・X線ビームが電極、絶縁材に当たらないように配置する。
- ・ノイズの少ない高圧電源を使用する。
- ・信号捕集用電極の位置がずれると、電場補正用電極と触れやすいので振動、衝撃を与えな いこと。
- ・湿気が入るとリーク電流が増え、ノイズの原因となるので大気に開放しないこと。
- ・電離箱、信号ケーブルの振動はノイズ源となるので、振動を避けること。
- ・電動昇降ステージ等との間を電気的に絶縁すること。

等である。通常積層乾電池を電源として使用している。また、信号ケーブルに low noise cable を 使用しているステーションもある。Low noise cable には赤い熱収縮チューブが巻いてある。 X線によって電離されたガスはそのままでは直ぐに再結合してしまう。これを防ぐために電場



を印加している。使用するガス、入射 X 線強度、印加電圧と信号電流の関係を図 7.2.2 に示す。 図で立ち上がっている部分は再結合が無視できない部分で、別の表現をすると出力電流が入射光 子束に比例しない部分である。従って、十分に飽和した状態で使用する必要がある。経験では見 かけ上の飽和点の倍程度の電圧を印加すると安定になる。(a)と(b)を比較すると、吸収率が高い 程、飽和する電圧が高くなる。また、(a)と(d)を比較すると、入射光子束(より正確には光子密 度)が高くなるほど飽和する電圧が上がる。これらは電荷密度の差に由来する。空気の組成は 79% の窒素、20%の酸素と 1%のアルゴンであり、検出効率は Ar(0.25)+N₂(0.75)よりも低い。従って 電荷密度も低くなるので、より低い電圧で飽和しそうであるが、(b)と(c)を比較すると逆になっ ている。これは酸素がアニオンとなってカチオンと再結合を起こしやすいためである。この様に 酸素、水等が電離箱に入ることを防ぐ必要がある。

7.2.2 電離箱に印加する電場について

7.2.1 節に記したように、電離箱にはイオンと電子の再結合を防ぎそれぞれの電荷を補集する ために電場を印加する。必要となる電場は入射×線によって電離したイオン・電子の密度で決ま リ、従って、使用するガスの種類・圧力、ビームの断面形状、強度に依存する。各実験ステーシ ョンで得られるビームの大きさ、強度は図 1.5.1 や第6節に記した様に異なる。従って、必要と なる電場強度はステーション、実験条件によって異なる。原理的には電場を増せば再結合は防げ るが、電離箱内部の耐電圧や作業時の安全性を考慮して、最大印加電圧を 2kV 程度に抑えてい る*。このため、BL-9A では他のステーションと異なるガスの選択を余儀なくされることがある。 必要な電場を求めるには図 7.2.2 に示したように電場を変えながら出力信号を測定して曲線を 描き、見かけの飽和電場の2倍程度をかけるのが好ましい。電場が十分である場合は検出系の直 線性が高いので、入射前後でもμt が不連続とならない。またこの様な条件では(試料側に問題

が無い限り)グリッチ等で入射強度が急変してもμtではキャンセルされる。

7.3 装置の起動

実験を開始する前に次の機器の電源を入れる。通常殆どの電源は入った状態になっている筈で あるが確認すること。これらのスイッチには**赤いシール**が貼ってある。また特に必要の無い限 りこれらの電源を切らないこと。なお主な機器の通常の設定位置には黄色または緑色のシールが 貼ってある。どのステーションでも基本的に同じであるので、BL-12C を例に取り、実験を開始 する前に投入すべき電源類を示す。ここに記す機器配置、型番は執筆時点のものであり、故障、 改良等のために変更される場合がある。それらは当該ステーションの log book に記す。

1. 測定器用ラック内の電源スイッチ

上から RING CURRENT(DCCT)のトグル SW (リングの蓄積電流表示) NIM BIN のトグル SW (V/F、HV 等) (許可なく切らないこと) ロータリーエンコーダーのカウンター(VRZ460) (許可なく切らないこと) パルスモーターコントローラー(PM4C-05)のプッシュ SW ピエゾ素子用高圧電源のトグル SW(P-862) PC 用 CRT のプッシュ SW マイクロコンピューター本体のプッシュ SW

[「]大きな放電を起こすと、電流増幅器を破損し、積層乾電池を焼損する恐れがある。

拡張ボックス(PC9811)のプッシュ SW(通常 ON になっている)

レーザープリンターのシーソー SW

- モノクロメーター周辺 (通常 ON になっている)
 モノクロメーター下部のトグル SW (パルスモータードライバー用電源)
 冷却式送水装置の SW(モノクロ用、スリット用)
- 3. ハッチ内

電流アンプのトグル SW(2 ケ) (許可なく切らないこと) ステージ下部のトグル SW(2 ケ) (ステージ上下用パルスモーター)

- クライオクーラー位置調整用モータードライバー
- ロータリーポンプのプッシュ SW(クライオクーラーの排気用、投入前にバルブが閉まっていることを確認)
- クライオクーラー真空計測用熱電対真空計(MTG-011)の電源プラグ

BL-7C、BL-10B では下側の NIM BIN の電源を入れる。

- BL-10B にはない。BL-7C では ND261。
- BL-10B では IPM2C-01。
- BL-9A では左隣のラックにある。BL-10B にはない。
- BL-12Cのみ
- BL-10B では冷却式送水装置のプラグを入れる。BL-9A ではモノクロメーター用とミラー用と 2 台ある。BL-7C はモノクロメーター用の1 台のみ。
 - BL-7C、9A、10B ではスイッチは1 個。
 - BL-7Cにはない。BL-10Bではステージ下部に置かれたボックスの電源。
 - BL-7Cにはない。BL-10B、9Aではハッチ外にある。
 - BL-7C にはない。

7.4 **測定条件の**設定

ここでは単色X線ビームとスリットの位置関係がはぼ良好でモノクロメーターの調整が既に完 了している場合を仮定している。そうでない場合は4.1、4.8節を参照のこと。

7.4.1 Io前スリットの調節

XAFS 測定用ステージの一番上流側に四象限スリットが設置してある。このスリットは最終的 に試料に入射するビームの形状を規定する。従ってこのスリットを通過するビームの強度が最大 となり、ビームの形状がこのスリットで規定される事が望ましい。

先ず Linagraph を I₀前スリットの上流側に貼って入射ビームの形状と位置を確認する。ビー ムがスリットの中心から外れている場合は、上下方向のずれに関してはステージを上下して、水 平方向のずれについては SLIT CONTROLLER を用いて大体合わせる。BL-10B の場合の水平動 は手動で調整する。これらの位置を変更した時は日時と共に log book に記録する。BL-7C、9A、 12C ではモーターコントローラーの読み(ステージの上下は PM4C-05 の C チャンネル、水平動 はオプトマイクコントローラー)を、BL-10B ではステージの昇降については IPM2C-01 の A-CH の値を記録する。BL-7C、10B のスリットの水平動はマイクロメーターヘッドの読みを記録する。 次にスリットを希望の大きさにし、I₀用電離箱の出力をディジタルパネルメーターで見ながら 4.8 節に記したと同様にして二結晶の平行度を合わせ、再度ステージの上下とスリットの水平移 動をして最大強度となるところを探す。この操作を何回か繰り返す。ディジタルパネルメーター の表示及びその前段の回路系は約±10V で飽和するので、飽和しない様に電流アンプのゲイン を選択する。スリットの開きはマイクロメーターヘッドを手動で調整して決める。通常の吸収ス ペクトルの測定では BL-7C、10B では横5~10 mm×縦1mm 程度、BL-9A、BL-12C では縦横各1mm 程度の大きさのビームを用いる。

なお、BL-7C で集光した場合や BL-9A、BL-12C ではビームの発散が大きいため、スリット から離れるとビームの大きさ、形状が変化する。従って試料が小さい場合は出来るだけ近づける べきである。スリットの前後でのビームの形状をリナグラフやポラロイドフィルム等を用いて点 検する。

7.4.2 電離箱用ガスの選択

電離箱へ供給するガスの配管は図 7.4.1 の様になっている。各ラインのボンベの位置は表 7.4.1 に記す。10ℓボンベ以外のボンベの主バルブは通常開いている。制御部は各ステーションのハッチの脇にある。

	スパーロスグ ションのホン N量と物					
	47 ℓボンベ(主に N₂-Ar 系ガス)	その他のボンベ				
BL-7C	ハッチ上	ハッチ上流側				
BL-9A	ハッチ下流側	ハッチ下流側				
BL-10B	ハッチ裏(BL-11)側	ハッチ裏(BL11)側				
BL-12C	ハッチ手前(BL-13)側	ハッチ上流側				

表 7.4.1 各ステーションのボンベ置き場

ガス及び用いる電離箱の選択によって検出効率が大きく変化する。 I_0 用電離箱のX線に対する 吸収率は統計精度の観点からは 15% 位(10~25%) が好ましく、I 用電離箱の場合は 90%位が好 ましい(第二部 2.1 節)。但し、10⁹ photon/s 程度以上の光子の入射する XAFS 実験では光子の 統計精度がスペクトルの S/N を決めることは稀であるので、 I_0 について必要以上にこの値に拘 る必要はない。I 用のガスでは基本波に対する検出効率と高調波に対する検出効率の比の大きい ものが好ましい。検出効率の概算値及びこれに基づくガス及び電離箱の選択については第二部に 記す。現在ステーションで用意しているガスは N₂、Ar、N₂ - Ar 混合ガス(Ar が 15、25、50%) 及び N₂ - He 混合ガス(N₂が 30 叉は 10%)である。但し N₂ - He 混合ガスは BL-10B には配置 していない。また、時により Kr ガスを用意している。

用いるガスを交換する手順はいくつかあるが最も一般的な方法は以下の通り(図 7.4.1 参照)。I₀ 用電離箱のガスを N₂から Ar に交換する場合を例にする。通常 N₂ - He ガスを除き主バルブは開 いている。閉じている場合は開ける。

- 1. N₂用の VI₀を閉じる。
- 2. バイパス弁 Vb-I₀を開き、配管中のガスを放出する。
- 3. パネルに取り付けられた圧力計が 0 になったら、ガス切り替え弁 V SEL-I₀ を N₂ から Ar に 切り換える。
- 4. Ar 用の VI₀を開き、バイパス用流量計の目盛りが 1ℓ/min 程度になるよう調節し、電離箱内のガスを置換する。 蛍光 XAFS 用電離箱を用いる場合は検出器を接続せずに配管内のガスを置換し、その後流量を 0.1ℓ/min 程度に抑えて検出器を接続する。これは蛍光 XAFS 用電離箱の窓は薄く、広いので圧力を掛けて窓が伸びて、マイクロフォニックノイズの原因となる



ことを防ぐためである。

- 5. 数分程度してガスが置換されたなら、バイパス弁 Vb-I₀を閉じ、流量計の目盛りを 2~5cc/min 程度に調整する。Kr へ置換する場合は時間を短縮する。一般的に重いガスから軽いガスに 置換するときは長目に行う。ここでバイパス弁を閉め忘れるとボンベが空になるのでタイマ ーを使うことを推奨する。
- ボンベの一次圧を時々記録する。目に見えて圧が低下するような場合は配管に洩れがあるの で点検、修理を行う。
- 注1 ガスの置換が不良だとブロックの区切りでスペクトルの傾きが変わる。
- 注 2 **バイバス弁(Vb)を締め忘れないこと**。混合ガスは納期が長く、その間実験できなくなる。 また Kr ガスは 10ℓボンベ 1 本で 13 万円程度する。
- 注3 Vout は電離箱の出口バルブであるので通常開けておく。Vout を閉じてバイパス弁を開ける と圧力がかかり電離箱の窓を壊すことがある。
- 注4 電離箱の窓に穴を開けないよう注意すること。 洩れがあると測定中にガスの組成が変化し、 スペクトルに異常が出る。**穴を発見した場合は担当者に連絡すること**。粘着テープを用い ると粘着剤中の微量の不純物^{*}で吸収端が観測されたり、厚さむらによるトラブルが生じる ことがある。

^{*}例えばスコッチテープ中には多量の硫黄、塩素、臭素が含まれている。



2



1983 12.21 野村 1/1 試料ホルダー (I) KEK-PF 三 乃 法

t 1

図 7.4.2 試料ホルダーの一例 2.2 のキリ穴は皿もみした方が良い。

この方法は簡便であり、通常の測定には充分であるが、以下のような問題点も持っている。

1. ガスを完全に置き換えるにはかなりの時間を要する。

2. 開放系であるので大気圧の変動の影響を受ける。

従って、より精密な測定を必要とする場合は電離箱の真空排気、ガス封入を繰り返し、封止状 態で使うことが望ましい。この場合は僅かな洩れによっても感度が変化するので取り扱いには細 心の注意が必要である。また排気時は高圧電源、電流増幅器の接続を外す必要がある。高圧を印 加したまま真空排気すると放電が生じ、電流増幅器、電源の双方を壊す恐れがある。

7.4.3 試料の取り付け

通常の金属箔や粉末試料の場合、サンプルホルダーを用意してそれに試料を取り付けると便利 である。試料ホルダーの一例を図 7.4.2 に示す。外側の四つの穴にネジを通して試料ホルダー治 具に取り付けるようになっているのでこの穴位置を合わせれば他の形状でも取り付けられる。但 し余り大きな物は周囲の物にぶつかるので、この図の大きさより余り大きくしない方がよい。

先にも記した様に I₀前スリットを通ったビームの強度を電離箱でモニターして、強度の規格 化をしているので、**このスリットより下流側で試料以外のものでビームを切ってはいけない**。 また試料の無い部分をビームが透過しては正しいスペクトルを得ることは出来ない。従ってX線 が試料の中を透過する様に試料の位置を調整しなければならない。試料に組成や厚さのむらがあ ることはこれらと等価であるので、試料の均一性にも注意を払う必要がある(第二部第 2 節参 照)。

いくつかの試料位置設定方法を示す。詳細については各実験者で検討すること。

- A) Kodak 社製の"Linagraph Direct Print"と呼ばれるX線検出紙を試料ホルダーに取り付けてビー ムの像を記録すればビームの位置が分かる。"Linagraph"は撮影したその場で像を観察できる。 この像の位置をトースカンの針先に移したり、レーザーポインターでマークしておけばそれ らと試料の位置を合わせれば良いことになる。
- B)ビームの位置は大体予想できるので、その予想位置の付近にトースカンの針先を置き、ポラ ロイドフィルムで写真を撮る。ビームの像と針先の影からビーム位置が分かる。ビームの位 置が決まったらそれをトースカンの針先やレーザーポインターに移しておくと便利である。
- C)図 7.4.3 に示すような治具をクライオクーラーの試料ホルダーに取り付け、クライオクーラ ーのステージを上下方向に動かしながらI用電離箱の出力が最大になる所をを探す。最大地 点が見つかったらポラロイドフィルムでこの治具の影を撮影する。写ったパターンから容易 に穴位置とビームの関係が分かるであろう。先と同様にビーム位置をトースカンの針先やレ ーザーポインターに移しておく方がよい。

このようにして決まったビーム位置に合わせて試料をセットする。いずれの場合も I₀前スリットを透過した直後のビームイメージと試料透過後のビームイメージを比較しておく方がよい。 通常一度試料位置を決めたら、試料交換の度に写真を撮る必要はない。但し、試料の厚さむらや ピンホールが予想されるときはポラロイド写真を撮って点検すべきである。

図 7.4.3 ビーム位置合わせ用治具 の一例。

トースカンを使用するときは以下の点に注意が必要である。

- トースカンの針先で電離箱の窓に穴を開けないこと。このためには電離箱の窓にLinagraph
 を貼るのではなく、試料ホルダーに貼ること。
- キャリアの固定が甘いと針先の位置は意味が無くなる。しっかり固定してから位置合わせ をすること。
- トースカンの針先はなるべく水平に近い状態にした方が誤差が小さくなる。トースカン針の固定部付近をドライバーの柄等で軽く叩くと針先の位置調整をし易い。

レーザーポインターを使用するときは以下の点に注意が必要である。

- キャリアの固定が甘いと意味を持たなくなる点はトースカンと同じ。
- ・ 試料と非接触であるので、試料とポインターの距離を一定にしないと意味がない。

7.4.4 電流増幅器の設定

電流増幅器はステージ上(BL-9A、10B では近くの棚上)に置いてあり、ラック中央のディ ジタルパネルメーターの表示を見ながらその利得を決定する。主な注意点は以下の通り。

- 1. 電流増幅器及び V/F 変換器は XAFS 実験にとって極めて重要な機器である。実験に先立ち十分なエージングが望まれる。従って、不必要に電源を切らないこと。
- 2. 電流増幅器及び V/F 変換器を最も直線性の良いところで使う様に出力信号が 1V のオーダー のなるべく高い値(出来れば 5V 以上)になるようにする。
- 3. 全スペクトル領域で信号の絶対値が 10V を超えないようにする。一度オーバーフローすると 相当長時間に亘ってドリフトが観測される。

- 4. rise time を適当に設定する(通常 100ms)。 $I_0 \ge I$ は同じ rise time である方が望ましい。
- 5. 電流補償器(Current Suppression)の性能は電流アンプ本体より劣るので使用しない。またシャ ッターを閉じたときのカウント数が0の場合は ZERO ADJ を調整して毎秒数十カウント程度 のオフセットがあるように調整する。このオフセットは OFFSET 測定をしておけば、プログ ラム中で差し引かれる。
- 6. 結線を変更したときは必ず元に戻す。誤って高圧を接続しないように注意する。 不注意により破損すると数十万円の修理費が必要となるのみならず、数ヶ月に亘ってステーションを閉鎖せざるを得なくなる。
- 7. 電流増幅器の温度が変化すると温度ドリフトが生じるので、ハッチの中に熱源を持ち込まな い様にする。

 ルール
 ・ユーザーは USER>以外のディレクトリにアクセスしないこと。本取説に記 された全ての動作はディレクトリ USER で出来る。
 ・マイコン周辺のスイッチ類の設定、結線を許可なく変更しないこと。 許可を受けて変更した場合は終了後元に戻し、動作確認を行うこと。
 ・ハードディスクを初期化しないこと。

8.1 計算機の仕様

執筆時点の各ステーションの制御用計算機の主な仕様は以下の通り。

	BL-7C	BL-9A	BL-10B	BL-12C
マイコン	NEC	NEC PC9821Ap	NEC	NEC PC9801DA
	PC9801FA/U2		PC9821Xs/U7W	
CPU	486DX2	486DX2 66 MHz	486DX2 55 MHz	80386
	31.9MHz			
OS	MS-DOS	MS-DOS ver.6.20	MS-DOS ver.5.0A	MS-DOS ver.5.0A
	ver.5.0A			
日本語入力				
データ記録媒体				
ハードディスク				
3.5"FDD				
5.25" FDD	-	-		
MO(128/230MB)	-		-	
レーザープリンタ	Canon	Canon	Canon	Canon
	LBP-A404E	LBP-A404E	LBP-A404F	LBP-A404G
トナーカートリッジ	EP-L	EP-L	EP-P	EP-P

注:

ステーションによる機器の差は開発、更新時期の差に由来するものである。今後とも変更される場合もある。

8.2 周辺機器についての注意

8.2.1 フロッピーディスクドライブ

各ステーションで扱えるディスクの規格、フォーマット方式及び IBM の DOS/V 規格との互 換性を表 8.2.1 に記す。元来 NEC の PC9800 シリーズのパーソナルコンピューターは IBM 規格 の 3.5" 1.4MB フロッピーディスクをサポートしていなかった。一方、最近は 1.4MB が標準的 なフォーマットとなっている。BL-7C、12C ではこれに対応するため特殊なフロッピーディスク ドライプを使用している。

BL-9A、10B については特別な注意事項はない。ディスクのラベル面を上側にして挿入する。 また、フロッピーディスクを書き込み許可状態にしておく。

BL-7C、12C では特殊な 3.5"フロッピーディスクドライブを使用している。通常の 640kB/ 720kB/1.2MB にフォーマットしたディスクを使用する場合はディスクドライブの緑のシールを

ディスクフォーマット	スイッチ	IBM 互換	BL-7C	BL-9A	BL-	BL-
		性			10B	12C
3.5 インチ						
2DD (640kB) 8sec/tr	なし	×				
2DD (720kB) 9sec/tr	/9					
2HD (1.2MB) 8sec/tr	なし	×				
2HD (1.4MB) 18sec/tr	/4					
5.25 インチ						
2DD (640kB) 8sec/tr	なし	×	-	-		
2DD (720kB) 9sec/tr	/9		-	-		
2HD (1.2MB) 8sec/tr	なし	×	-	-		
2HC (1.2MB) 15sec/tr	/5		-	-		

表 8.2.1 各ステーションで扱えるフロッピーディスクの規格と互換性

sec/tr はセクター / トラックの略

スイッチはフォーマット時に付けるスイッチを意味する(例 FORMAT B: /4)

2DD でフォーマットする時は 2DD 用の、2HD, 2HC の時は 2HD 用のディスクが必要。

は特殊な取扱を必要とする(後述)。

貼ったボタンが飛び出し、近くの赤い LED が消灯した状態で使用する。この時のドライブ名は ドライブに書かれた名前の内若い方である(D/Fと書かれていたらD)。

1.4MB(IBM compatible format)を使用する時は緑のシールを貼ったボタンを押して、近くの 赤い LED が点灯している状態で使用する。この時のドライブ名はドライブに書かれた名前の内 大きい方である。また、この状態ではディスクのフォーマット、ディスクコピーに関しても特殊 なコマンドを使用する(8.4 節参照)。使用法を誤るとデータを書き込めなかったり、書き込ん だデータに上書きしたり、持ち帰って読めないこともある。ステーションの log book に記され た注意を良く理解してから使用すること。このような誤りをしたときは、被害を最小限にするた め、それ以上データを書き込まず野村まで連絡すること。条件が良ければかなりのデータを復旧 出来る。

今後、5.25"ディスクのサポートは廃止する方向にある。

8.2.2 MOディスクドライブ

BL-9A、12C では多素子 SSD の利用に対応するため 3.5" MO ディスクドライブを設置してあ る。**誤ってフロッピーディスクを挿入しないこと**。また、フォーマットには時間が掛かるので、 予めフォーマットしてから持って来ること。読み書き出来るディスクは 128/230MB のディスク に限定される。なお海外では MO は余り普及していないので注意が必要。

8.2.3 レーザープリンター

- ・ ON LINE 状態にあることをオンライン (ON LINE) スイッチの緑色の LED で確認する。
- ・ 紙切れ、ジャム等正常に印刷出来ない状態が発生すると測定が停止状態になる(出力待ち状態になる)。パソコンがハングアップしたように見える時はレーザープリンタの障害を疑うこと。特に BL-10B のレーザープリンターでエラーの発生が多い。
8.3 ソフトの概要

計測制御用としては以下の四つのソフトをサポートしている。 BLnnn01:XAFS測定、データ出力用 第9節参照 FDMC : Focusing Double Mirror 制御用(BL-7Cのみ) 5.5.4節参照 MIRC2 : Mirror 制御用(BL-9Aのみ) 5.5.6節参照

バージョンアップ等のためプログラム名は変更される場合があるので、log book の記載事項 に注意すること。

8.4 OSに関する知識

プログラムは MS-DOS(®Microsoft Corporation)の上で走る様に作られている。MS-DOS は Windows が主流になる前の時代の OS で、基本的に character ベースの single user、single task の OS である。GUI(Graphical User Interface)に慣れた方は最初違和感を覚えられるかも知れないが、 Windows よりもはるかに安定なシステムであり、訳の分からないエラーメッセージに悩まされ たり、突然爆弾マークが出てハングアップすることも極めて少ない。

OS(オペレーティングシステム)の詳細について知る必要はないが、以下の事を知っておく と便利である。以下のコマンドは全て A:¥USER>が CRT に出ている状態で入力する。以下例に 用いるドライブは B とする。ドライブ C を使う場合は B:の代わりに C:とすること。

イ.フロッピーディスクのイニシャライズ

MS-DOS に詳しくない方は IBM フォーマット(1.44MB)済みのディスクを持ってくることを 勧める。

- NEC フォーマット(1.2MB)の場合
 - FORMAT B: 又は FORMAT B:/V

後者はディスクにボリュームラベルを付ける時に用いる。

BL-9A、10Bで1.4MBフォーマットの3.5"ディスクを用いる場合

FORMAT B:/4 又は FORMAT B: /4 /V

BL-7C、12C で 1.4MB フォーマットの 3.5"ディスクを用いる場合

FDFMT F: /18 または FDFMT F: /18 /V

スラッシュの前はスペースを空けること。

以下 CRT 上に出る指示に従って操作する。これ以外のフォーマットについては 8.2.1 参照。 フロッピーディスク(FD)はラベル面を上側に向けて入れる。

イニシャライズすると FD 中の全てのデータが読めなくなるので注意。

測定を始める前に何枚かイニシャライズしておくことを勧める。

口.FD 中のファイル名のリストをとる

DIR B: 又は DIR B:/W

前者の場合はファイル名と共にファイルサイズや作製日時等も表示される。 後者の場合はファイル名のみが表示される。

八.ファイルの複写

測定中にFDが一杯になるとデータファイルはハードディスク(HD)上に作られる。持ち帰る為にはFD等に複写し、HD上のそのファイルを消去する。

する。FD 上の名前も DATA001.D にする)

COPY A:*.D B:/V (HD 上の拡張子が D のファイルを全て B:ドライブに複写する)

ニ.ファイルの消去

DEL A:DATA001.D (HD 上のファイル DATA001.D を消去する) DEL A:*.D (HD 上の拡張子が D のファイルを全て消去する) 誤って必要なファイルを消去しないように注意する。

ホ.フロッピーディスク / MO のバックアップ

フロッピーディスク / MO のバックアップ (ボリュームコピー)をとるときは、

DISKCOPY B: C:

- とすると、B:に入れたフロッピーディスクのコピーが C:に入れたディスクに作られる。これ はハード的なコピー作業であるので、C:に入れたディスクに書かれていたデータは消去される。 また、ドライブ名の順番を間違えると悲劇を招く。念のため、コピー元のディスクは書き込み 禁止とする事が好ましい。
- MOの場合はドライブが1台しかないので、DISKCOPY F: F:の様に同じドライブ名を指定し、 表示される指示に従って入れ替える。
- BL-7C、12C で 1.44MB のディスクを使用する場合は
- FDCOPY F: G:

ヘ.ファイルの名前の制約

Windows や Macintosh、UNIX との差が大きいので注意が必要である。ファイルの名前は 1 ~8 文字の長さの "ファイル名 "と0~3 文字の長さの "ファイル名拡張子 "とから構成され、 その間にはピリオドを付けなければならない。使用できる文字は半角英数字及びS'()@&#^{}-_! である。大文字と小文字の区別はなされない。拡張子は省略しても構わないが、パラメータ ーファイルについては PAR か P、データファイルについては D か DAT という拡張子を付け ると後で便利。

良いファイル名の例	CUFOIL.D	MO000001.DAT	CUKEX.PAR
悪いファイル名の例	MO8611191.D	(ファイル名が長	過ぎる)
	TIK.EX.PAR	(ピリオドが多過	ぎる)

ト.ディレクトリーについて

MS-DOS にはディレクトリーという概念があるがこのソフトではデータファイルを全てカレント(今開いている)ディレクトリー上に作っている。通常フロッピーディスクの場合はルートディレクトリである(プログラム起動前にデータディスクのディレクトリを変更しておけば、そちらに記録される)。また HD の場合は A:¥USER という通常ユーザーが操作をするディレクトリに書かれる。

OSについてこれ以上の情報についてはステーション備え付けの「MS-DOS 5.1 ユーザーズマ ニュアル」参照のこと。

第9節 XAFS測定用ソフトウェアの利用

XAFS を測定する為のソフトウェアを用意してある。執筆時点で使用しているプログラムの呼び出し方法は BLnnn01(nnn はビームライン名、例えば BL7C01、BL12C01)である。呼び出し 方法が変更された場合はステーションの log book に記す。プログラム起動前に各スイッチが所 定の位置に設定されていることを確認する(7.3 節参照)。この時点で各スイッチが所定通り設定 されていない場合の動作は保証しない。またいくつかの設定は CONDN.CND というファイルを 参照しているので、CONDN.CND を消してはならない。USER ディレクトリ以外に入らないと いうルールを守っている限り誤って消去することはない。

この BLnnn01 はプログラムを呼び出すためのバッチファイル(マクロ)であり、以下の三つ のプログラムを順次呼び出す。

SETCOND.EXE

DISKRW.EXE

MDHX02.EXE

ここで、SETCOND.EXE はデータをセーブするディスクや計数に使用するスケーラ等の動作環 境を指定する。次に DISKRW.EXE は指定したディスクに対する書き込み、読み出しテストを行 う。これは BL-7C、12C で使用しているフロッピーディスクドライブの操作ミスによってデー タがディスクに記録出来ない(ということに気づかずに実験を継続した)という障害が発生した ことに対応した処置である。その後、実際の XAFS 実験制御ソフト MDHX02.EXE が起動する。 これらのソフトの主要部は MS-FORTRAN で、一部は MASM で記述されている。

9.1 一般的な注意事項

このプログラムを使う上での一般的な注意事項をまとめておく。

- イ.以下のプログラムの説明ではメッセージと利用者の応答例を枠の中に示す。
 { }内は利用者の応答例である。{ }内の入力後、リターンキーを押すこと。
- ロ.ユーザーへの入力促進文中に DF: の表示(default の略)の後に数字が出ている所でその数 字のままで良いときは/(半角スラッシュ)を入力するとデフォルト値を入力したのと同等 に扱われる。

number of blocks (max 10) DF: 4
{/}

は4を入力したのと同じに扱われる。

DF: の無い入力促進に対して/を入力したときの動作は保証しない。

ハ.以下の様に数字の入力を求められた場合、1を入力すれば OK、1 以外の数値を入力すれば NGとみなす。数値以外を入力するとエラーと見なされる。

If OK, type 1

二.試料名以外の入力は原則として半角の英数字である。試料名については日本語も使用可能 である。日本語入力モードと半角入力モードの切り替えは CTRL/XFER(CTRL キーと XFER キーを同時に押下する)でトグル動作する。

ホ.入力の誤りについて

リターンを押す前の修正はカーソル又は BS キーを動かして行う。数字を入力すべき所に文 字を入力する・選択可能範囲以外の入力をする等の入力ミスについては出来る限りソフトで チェックする様にしている。この場合、再度入力促進が出るので正しい入力をする。これら 以外の入力ミスに付いてはチェックしていないので、入力時には注意する。

へ.STOP キーや CTRL/C を入力すると、プログラムは停止し OS へ戻る。プログラムがハン グアップした時以外は用いないこと。

9.2 動作環境の設定

以下の様にしてプログラムを起動すると、まず各種の動作環境の設定を行う。以下 BL12C の 場合を例にとって示す(他のステーションの場合、特に注意を要する点のみ注記する)

A:¥USER> {BL12C01} Which condition do you edit? 1--Data disk selection 2--Scaler selection 3--User PC control 4--Positron/electron energy 5--End (go to XAFS measurement) {1}

9.2.1 データ保存ドライブの設定

==== SET NEW DATA DISK DRIVE ====
1 : DRIVE A (HD)
2 : DRIVE B (5" 2HD DRIVE)
3 : DRIVE C (5" 2HD DRIVE)
4 : DRIVE D (3.5" 1.2MB DRIVE)
5 : DRIVE E (3.5" 1.2MB DRIVE)
6 : DRIVE F (3.5" MO (128/230MB))
7 : DRIVE G (3.5" 1.4MB DRIVE)
8 : DRIVE H (3.5" 1.4MB DRIVE)
{7}
NEW DATA DISK IS G

標準のデータ保存用ディスクドライブは 1.4MB 対応の 3.5"フロッピーディスクドライブとし てある。従ってパソコンの電源を入れた直後またはパソコンをリセットした直後はこの設定にな っているが、他のユーザーが使用した後は設定が変わっていることもあるのでプログラム起動時 には設定すること。また、上記の様にパソコンがリセットされると初期化されるので再指定が必 要である。

このメニューは各ステーションに備えられているドライブの環境によって異なる。ドライブは

上記の様に数字で選択するほか G、g 等のドライブ名を用いた指定も許容している。このように データはフロッピーディスク(FD)、ハードディスク(HD)、MO に保存できるが、以下の説明で は FD と総称する。

BL-7C、12C で 1.4MB 対応の 3.5"フロッピーディスクドライブを選定した場合は、アラーム音と共に以下の注意メッセージが出る。緑色のボタンの状態、LED の点灯状態を確認すること。

Please assure that a red LED of the 3.5" FDD drive is ON

この後、最初のメニューに戻る。

9.2.2 スケーラーの選定

次に、9.2.1 節の最初のメニューで 2 を選択して、使用するスケーラー、測定モードを指定する。

SELECT MODE
1: novice mode (for usual transmission and Lytle detector only)
2: expert mode (select scaler & assign mode for each channel)
{1}

通常は novice mode を選択する。novice mode は Ortec 974 スケーラーの Ch2 に I₀、Ch3 に I (または I_f)を接続して、透過法または蛍光 XAFS 用電離箱(Lytle detector)を用いた蛍光法実験に適している。透過法、蛍光法の切り替えも容易である。novice mode を選択した場合は再び 9.2.1節の最初のメニューに戻る。

expert mode では上記の標準的な接続と異なる接続法をする場合(例えば透過法と蛍光法で同時測定する)、および多素子 SSD を使用する場合に用いる。次に以下の様に実際に使用するスケーラーを指定する。

Select scaler: Ortec 974 (0) or CAMAC (1) DF: 1
{1}

これは通常の Ortec 974 スケーラの替わりに CAMAC のスケーラを選択した例である。CAMAC のスケーラーは執筆時点では BL-12C でのみ対応している。

9.2.3 ユーザーPCとの通信制御

このモードは例えばユーザーが持ち込んだパソコンで試料の温度を制御しながら XAFS 実験 をする、多数の試料を順次測定するというようなケースを想定して将来用に設けた。ターゲット もなしにソフトを作るわけにも行かないので、今後、実験の内容に応じて個別対応で通信規約を 整備していく。現在までのところ東京大学大学院理学系研究科の岩澤研究室と共同で DXP を介 した多素子 SSD の制御を BL-9A で試みている。

9.2.4 電子/陽電子のエネルギー

ここでは蓄積リング中を回っている荷電粒子のエネルギーを入力する。通常は 2.5GeV に設定 されているが、時に 3GeV 運転時には以下の様な変更が必要となる。

Input the value of positron/electron energy in GeV unit. DF:2.5 {3.0} 注記するまでも無いが、データファイルに記録するための単なるメモであり、これを変えたから と言ってリングを回っている荷電粒子のエネルギーが変わるわけではない。

9.2.5 設定の終了

必要な設定が終了したら、9.2.1 節の最初のメニューから 5 を選択する。これによって、設定 値がファイルに書き込まれる。このファイルは XAFS 測定ソフト等によって参照される。

9.3 データの読み書き

必要な設定が終了したら、次にデータ記録媒体に対してデータの書き込み、読み出しのテスト を行う。これは特に BL-7C、12C 等の特殊な使用法をするフロッピーディスクドライブでの事 故を防ぐことを目的としている。

| Test if the assignment of the drive is correct or not. | | Note the message. Batch file does not stop. | === writing test data === Z9Z9Z9Z9.Z9Z is the test file. If this is not your file, delete it.

テストに用いるファイル名は **Z9Z9Z9Z9.Z9Z** である。同名のファイルが既にデータ媒体(の当該ディレクトリ)上に存在する場合は次の様なエラーメッセージが出る。このファイルがデータ 読み書きテストに依って作られたものである場合は、消去を指定する。

****** THE FILE ALREADY EXISTS ! *** IF DELETE OLD ONE, TYPE 1 {1}

ここで、1以外を入力すると無限ループに入ってしまうので、万が一 Z9Z9Z9Z9Z9Z9Z が必要な (消去出来ない)ファイルである場合は、STOP キーを押して処理から抜け、リネームする。

=== reading test data === === data read/write succeeded === Stop - Program terminated.

データの書き込み、読み出しテストに成功すると上記の様なメッセージが出て、処理を終了し、 次の XAFS 測定ソフトを呼び出す。最終行のメッセージはこのデータの読み書きテストプログ ラムが終了した意味であり、気にする必要はない。万が一読み出し時に書き込んだデータと差が あった場合はアラーム音が鳴動し、以下の様なエラーメッセージが出る。ただし、エラーがあ っても処理は先へ進むので、注意すること。また、このテストでは異常が無くても、設定を誤 っていると他のPCで読めないディスクとなっていることもあるので、注意が必要である。

9.4 XAFS**測定用ソフトの構成**

実際に XAFS スペクトルの測定、データの出力等を行うプログラムは MDHX02.EXE である。 プログラムは、主に Expert モードで検出系の設定・テストを行う ASSIGN & CHECK DETECTORS、 モノクロメーターの角度移動等を行う PREPARETION、XAFS 測定条件の設定を行う SET SPECTRAL CONDITION、実際の測定を行う MEASUREMENT、データの出力処理をする OUTPUT、 繰り返し測定データの加算等を行う APPENDIX から成る。全体の構成図を表 9.4.1 に示す。

| プログラム中に虫を見つけた方は担当者までお知らせ下さい。 |

一般的な流れは次の通りである。

[目的吸収端の変更] PREPARATION MANUAL MOVE(ANGLE)

[最初の測定]

SET SPECTRAL CONDITION (DEFINE NEW PARAMETER 叉は USE STANDARD PARAMETER)

MEASURE

[二回目以降の測定]

SET SPECTRAL CONDITION (READ PARAMETER FILE) (全く同一の条件であれば省 略可)

MEASURE

MAIN	ASSIGN & CHECK DETECTORS	Assign detection mode
		Check countings
		Return to main
	PREPARATION	MANUAL MOVE (PULSE)
		MANUAL MOVE (ANGLE)
		MEASURE ROCKING CURVE
		RETURN TO MAIN
	SET SPECTRAL CONDITION	DEFINE NEW PARAMETER
		READ PARAMETER FILE
		USE STANDARD PARAMETER
		(EXAFS)
		USE STANDARD PARAMETER
		(XANES)
		END
	MEASURE	
	OUTPUT	CD OUTPUT
		LP OUTPUT
		GD OUTPUT
		PLOT OUTPUT
		DATA INPUT
		RETURN TO MAIN
	APPENDIX	sum data
		angle-energy calc.
		return to main

表 9.4.1 プログラムの構成

初期に現れるメッセージ、処理すべきことは Novice mode と Expert mode で異なる。

9.4.1 Novice modeの初期処理

Novice モードを選択した場合は以下の様なメッセージが表示される。

| You must use NIM counter/timer(Ortec 974) | | IO: Ch 2, I or If: Ch 3, NC: Ch 4 |

この後、GP-IB、シリアル I/O 等の初期化を行い、メインメニューに(9.5 節)に行く。万が一、 予定と異なったスケーラーが示された場合は、メインメニューで END を選択して、最初からや り直す。

9.4.2 Expert modeの初期処理

Expert モードで Ortec 製スケーラーを選択した場合は以下様なメッセージが表示される。

| You must use NIM counter/timer(Ortec 974) | | instead of CAMAC scaler (4434) and timer (3655) modules |

または CAMAC のスケーラ (LeCroy 4434)の場合は以下のメッセージが出る。

| You must use CAMAC scaler (4434) and timer (3655) modules | | instead of NIM counter/timer(Ortec 974) |

.....

万が一、予定と異なったスケーラーが示された場合は、メインメニュー(9.5 節)で END を選 択して、最初からやり直す。

9.4.3 制約事項

この測定ソフトには以下の様な制約がある。

- ・データ点数は1スペクトル当たり最大1000点である。
- Ortec 974 スケーラを用いた時の入力信号は3種類までである。
- Ortec 974 スケーラを用いたときの最大計数は 99999999(=10⁸-1)である。オーバーフロー に対しては特段の処置をしていない。
- CAMAC のスケーラーを用いた場合の入力データは 22 チャンネルまでである。但し、この 他に ICR 信号用に同数のチャンネルを使用出来る。
- CAMAC のスケーラー(LeCroy 4434)を用いたときの最大計数は 16777215(=2²⁴-1)である。オーバーフローに対しては特段の処置をしていない。
- ・繰り返し測定の場合の最大繰り返し回数は1000回である。但し、実際上はデータ記録媒体 の容量で決まることが多い。
- · その他の制約事項については該当する個所で説明する。

9.5 メインルーチン

システムの初期設定と各サブルーチンの選択をする。Novice モードを選択した場合は以下の メニューが出る。Expert モードを選択した場合は 9.6 節の設定をした後にこのメインメニュー に入る。

NUM	MODE
0	 ASSIGN & CHECK DETECTORS
1	 PREPARATION
2	 SET SPECTRAL CONDITION
3	 MEASURE
4	 OUTPUT
5	 APPENDIX
6	 END

希望するサブルーチンの番号を入力する。各サブルーチンの内容は以下の通り。ASSIGN & CHECK DETECTORS:検出系の設定、計数確認PREPARATION: モノクロメーターの角度送りSET SPECTRAL CONDITION: 測定条件の設定OUTPUT: データの CRT、レーザープリンター等への出力、入力APPENDIX: 繰り返し測定データの和から平均を求める、角度とエネルギーの換算をする。END: プログラムの終了

Expert モードを選択した場合は最初に ASSIGN & CHECK DETECTORS で検出系の設定をする 必要がある(デフォルトで当該ルーチンへ行く)。測定前には SET SPECTRAL CONDITION を経る 必要があるが、直前に採ったスペクトルと同一条件で測定するときは測定条件がメモリー上に 残っているので SET SPECTRAL CONDITION を経ずに、直接 MEASURE を選択してもよい。当 然ながらプログラムを一度終了した時は SET SPECTRAL CONDITION を経る必要がある。

9.6 検出系の設定・計数確認

Expert モードでは検出系の各チャンネルにどの信号を接続したか、その信号を取り込むか否 か等の設定が必要である。また、特に CAMAC のスケーラには表示器がないので、計数を確認 する場合に使用する。Expert モードでは最初にこの設定を行う必要があり、プログラムを起動 するとデフォルトで下記の ASSIGN & CHECK DETECTORS のサブメニューにとぶ。

NUM	MODE
1	Assign detection mode
2	Check countings
3	Return to main
{1}	

9.6.1 検出系の設定

まず、各チャンネルに接続した入力信号をプログラム上でも設定する。プログラム中では I₀ の強度で XAFS 信号を規格化してµt を求めている。また、透過法と蛍光法・電子収量法ではµt の求め方も異なるので、最初に指定しておく。Novice モードの場合は測定用サブルーチン(9.9 節)で設定する。CAMAC スケーラを選択した場合は以下のように表示される。

```
--- Mode for each channel ---
1:10, 2:trans., 3:fluo., 4:e-yield, 5:other, 0:ignore
ch:mode
         ch:mode ch:mode ch:mode
                                  ch:mode ch:mode
 1: 3
         2: 3
                  3: 3
                          4: 3
                                  5: 3
                                           6: 3
 7: 3
         8: 3
                 9: 3
                         10: 3
                                  11: 3
                                          12: 3
                        16: 0 17: 3 18: 3
13: 3
        14: 3
                15: 3
         20: 1 21: 0 22: 0
19: 3
If you change mode, type ch,mode end=0,0
mode<0 : not summed</pre>
{16,3}
{21,2}
{0,0}
```

まず、現在の設定が表示される。信号のモードは 1 が I_0 、2 が透過信号、3 が蛍光信号、4 が 電子収量信号であり、0 は取り込まないことを意味する。ここでは多素子 SSD を検出器として CAMAC スケーラを用いた例を示した。Ch16 を除く Ch1~19 は蛍光信号であるので mode は 3、 Ch20 には I_0 が接続されているので mode は 1 となっている。それ以外のチャンネルは使用しな いので mode は 0 と設定されている。ここではまず Ch16 を蛍光信号、Ch21 に透過信号を取り 込む設定をする。この様に設定するチャンネル番号とモードをカンマで区切って入力する。最後 の 0,0 は設定が終了したことを意味する。負の値はデータを取り込むが、CRT 上にスペクトル を表示する際には加えないことを意味する。

Ortec 974 スケーラーの場合は入力が4 チャンネルしかないので、次の様に示される。

--- Mode for each channel --1:10, 2:trans., 3:fluo., 4:e-yield, 5:other, 0:ignore
ch:mode ch:mode ch:mode ch:mode ch:mode
1: 0 2: 1 3: 2 4: 0
If you change mode, type ch,mode end=0,0
mode<0 : not summed
{4,3}
{0,0}</pre>

Ortec 974 を使用する場合、Ch1 はタイマーであるので mode には 0 を指定する。ここでは使用していなかった Ch4 を蛍光モードで指定している。

9.6.2 計数の確認

検出器の計数の確認をするために用いる。このルーチンは novice モードでも使用出来る。9.6 節の最初のメニューで Check countings を選択すると、測定時間の入力が求められる。通常はこ こにあるように1秒程度で十分であろう。

Dwell time/sec DF: 1.0000
{/}

指定した時間計数し、結果を表示する。Ortec 974 スケーラーを用いた場合の表示は以下の通り。

```
max count is 99999999
10 34567 45678 0
continue(1)
{0}
```

計数を繰り返す場合は1を、取り止める場合は1以外の数値を入力する。CAMACのスケーラーを用いた場合も同様に表示される。この場合は最初の3行は多素子 SSDの SCA(Single Channel Analyzer)の出力と1₀等、下の三行はそれに対応する ICR(Incoming Count Rate)信号とプリアンプのリセット回数である。

9.6.3 検出系の設定・確認の終了

9.6節の最初のメニューから Return to mainを選択すると、9.5節のメインメニューへ戻る。

9.7 準備用サブルーチン

- メインメニューで PREPARATION を選択すると以下の表示が出る。
 - 1 ---- MANUAL MOVE(PULSE)
 2 ---- MANUAL MOVE(ANGLE)
 3 ---- MEASURE ROCKING CURVE
 4 ---- RETURN TO MAIN
 {2}
- 1 は通常用いない。パルスモーターコントローラーを用いてモノクロメーターを動かすのと同等 の機能を有する。
- 2 は現在の角度と送り先の角度を入力することによって、マイクロコンピューターが必要なパル ス数を計算し、モノクロメーターを送る。BL-10Bの場合は 4.4.1 式に基づいて、ビーム高の 変化に追随するよう電動昇降ステージの高さも変える。
- 3はロッキングカーブ測定用のルーチンであって、通常用いない。

MANUAL MOVE(PULSE)

このルーチンを選択すると以下の表示がなされる。

MOTOR NO. & NUMBER OF PULSES POS: CW, NEG: CCW, ZERO: STOP {0,-36000} NO 0 CCW 36000 IF OK, TYPE 1 {1} Please note the status of motors!

ここではモーター 0(θ)を CCW 方向に 36000 パルス(1[°])送っている。この様に CW 方向に は正の値、CCW 方向には負の値を入力する。PM4C-05 の A POSITION、B POSITION は 0、1 と対応する。モーター番号、パルス数を入力後、確認を求められるので正しければ1を、誤って いたら1以外を入力する。モーターが正常に止まるのを確認する。 MANUAL MOVE(ANGLE)

このルーチンを選択すると以下の表示がなされる。

present angle/deg

{15.234}

現在のモノクロメーターの角度を入力する。入力値とエンコーダーの読みの差が 0.00015°より 大きい時は以下のエラーメッセージが出る。エンコーダーの設定が誤っている場合は設定し直し て(4.7.3節)、再度数値を入力する。

Your order is different from the encoder. Correct your order or adjust the encoder.

また、入力した角度が許容範囲を超えた不正なものである場合もエラーメッセージが出る。

*** illegal order ***

再度入力が促進されるので正しい値を入力する。入力値が受け付けられると以下の様に送り先の 角度の入力を求められるので、入力する。

Destination angle /deg {15.000}

目的角度まで送られるとエンコーダーとの照合を行い、誤差のあるときは補正する。なお、ギア のバックラシュを取り除くため、高角側から低角側へ送る方向で最後の調整を行っている。但し、 現在の角度と目的角度が同一の場合は何もせずにこのルーチンを終了する。

ROCKING CURVE MEASUREMENT

このルーチンをユーザーが必要とする事は殆どないので、説明を省略する。

RETURN TO MAIN

メインルーチンに戻る時に選択する。

9.8 測定条件設定サブルーチン

測定は全体を 10 以下のいくつかのブロックに分けて行う。各ブロック間で測定時間、各デー タ点間の送り角度(ステップ角)を変えられるが、各ブロック内では一定である。ここでは次の 測定パラメーターの指定をする。なお、上記では便宜的に角度と表記したが、エネルギー値での 入力も可能である。但し実際の制御は角度に換算して行われているので、角度での指定と比較し て誤差が大きくなる可能性はある。エネルギー値で入力した場合は各ブロック内は等エネルギー 間隔で測定する。主な指定すべき事項は以下の通り。

モノクロメーター結晶の面間隔	: D
測定ブロックの数(1~10)	: NBLK
測定ブロックの区切り角	: BLOCK(1)BLOCK(NBLK+1)
各ブロック内でのステップ角	: STEP(1)STEP(NBLK)
各ブロック内の1点当りの測定時間	: RTIME(1)RTIME(NBLK)
モノクロメーターの現在角	: PANG

全体の測定点数は 1000 点以下でなければならない。同じ条件でいくつもの試料を測定する場合 はパラメーターファイルを作っておき、二回目以降はそれを利用すると便利である。 メインメニューで SET SPECTRAL CONDITION を選択すると以下のような表示がなされる。

NUM MODE 1 -- DEFINE NEW PARAMETER 2 -- READ PARAMETER FILE

- 3 -- USE STANDARD PARAMETER (EXAFS)
- 4 -- USE STANDARD PARAMETER (XANES)
- 5 -- END
- {1}

1は新しくユーザーが独自のパラメーターを指定する時に用いる。

- 2 は既に作製したパラメーターファイルから測定条件を入力する時に用いる。現在角、測定時間 は変更できる。
- 3、4は利用者が細かいパラメーターを指定すること無く標準的なパラメーターに従って XAFS の測定条件を入力する時に用いる。

5はメインルーチンに戻る時に用いる。

SET NEW PARAMETER

これを選択すると以下の様な表示がなされる。

```
D/A DF: 3.13551
{/}
```

モノクロメーターの格子面間隔をオングストローム単位で入力する。通常は/(スラッシュ)を 入力する。時として結晶交換後パラメータファイルの修正を忘れていることがあるので注意。ま た、使用している格子面間隔は最新の値ではない(第二部参照)。一つのまとまりのある研究で は統一した値を使用すること。

```
number of blocks (max 10) DF: 4
{/}
```

測定に用いるブロックの数を入力する。EXAFS の場合は通常 4、XANES 近傍だけの形状を観 測する場合は1が一般的に用いられる。XANES でも、吸光度に関して定量的な議論をする場合 は吸収端から遠い場所で規格化する必要があるので3ブロック程度が必要であろう。

```
choose unit: angle(1), energy(2)
{1}
```

これ以降のブロックの区切り、ブロック内での送りを角度単位で入力するかエネルギー単位で入力するか指定する。

block separation angles (1)--(5)/deg {13.49,12.79,12.57,12.04,11.31}

各ブロックの区切り角度を度単位で入力する。角度の代わりにエネルギー単位で入力するときは eVを単位とする。

step angle (1)--(4)/deg {0.01,0.001,0.003,0.007}

各ブロック内のステップ角(各データ点毎の送り角)を入力する。角度の代わりにエネルギー単位で入力するときは eV を単位とする。

BL-10Bの場合は以下の様に channel-cut 結晶の溝幅を指定する。

Channel width of the monochromator/mm df: 9.5 {/}

以下、共通入力部へ

READ PARAMETER FILE

これは既に作製したパラメーターファイルがHD(ドライブA)上に存在し、それを利用する 時に用いる。ここでは CUKEX.PAR というパラメータファイルを読むとする。パラメーターフ ァイルの作り方については後述する。

指定したパラメータファイルが存在しない場合は、

というメッセージが出されるので正しいファイル名を入力する。ディスクドライブやディレクト リを変更する必要がある場合は##CHANGE.DRV と入力する。これはフロッピーディスク内にあ るパラメータファイルを利用する場合等に用いる。##CHANGE.DRV と大文字で入力すると、ド ライブ名、ディレクトリ名を含めたファイル名の入力を求められるので 40 文字以内で指定する。 入力を誤るとプログラムから抜けてしまう。

Input drive:¥directory¥file name
{B:¥PARAM¥CUEX1.PAR}

上記は B:¥PARAM¥CUEX1.PAR からパラメーターを入力する例である。

なお、パラメータファイルとしては現行の制御ソフトで作ったパラメーターファイル及び HX6814、EXAFS7 等の旧制御ソフトで作ったパラメータファイルの双方に対応している。また、 パラメーターファイル内で指定されている分光結晶面が現在使用している面と異なる場合、格子 面間隔が 0.001Å 以上離れている場合は以下のようなエラーメッセージを出す。

Although Si(111) is used, you use the parameter on Si(311) If you do not mind, type 1

但し、現行制御ソフトで作られたパラメーターファイルで、パラメーターが角度でなくエネル ギーで指定されている場合は1行目の警告のみを出し、処理は先へ進む。また、d の値が異なる 場合はどちらも同じ結晶面が表示されることもあるので注意すること。

また、旧パラメータファイルを読み、移動許容範囲外の角度が指定されている場合は以下のエ ラーメッセージを出し、READ PARAMETER FILE の最初に戻る。

*** FATAL INPUT ERROR OCCURED *** PLEASE TRY AGAIN

BL-10B の場合は以下の様に channel-cut 結晶の溝幅を指定する。

Channel	width	of	the	<pre>monochromator/mm</pre>	df:	9.5
{/}						

以下、共通入力部へ

USE STANDARD PARAMETER

標準的な測定パラメーターを用いて EXAFS、XANES を測定するときに用いる。 標準パラメーターは以下のように設定されている。

[EXAFS用]

: 4	
- 500eV	
	70 点
- 50eV	
	150 占
+ 100 eV $(\mathbf{k} \sim 5.1 \text{\AA}^{-1})$	100 /
100ev (k 3.1A)	160 占
	100 点
+ 500eV ($K \sim 11.5 A$	
	101 点
+ 1100eV (k ~ 17.0 Å ⁻⁺)	I

[XANES用]

測定ブロッ	ク数	:	1
測定開始	吸収端	-	30eV

測定終了 吸収端 + 70eV (k~ 4.3 Å ¹)

これを選択すると以下の表示がなされる。

```
D/A DF: 3.13551
{/}
```

モノクロメーターの格子面間隔をオングストローム単位で入力する。通常は/(スラッシュ)を 入力する。時として結晶交換後パラメータファイルの修正を忘れていることがあるので注意。

301 点

edge energy/eV {8980.3}

測定しようとする吸収端のエネルギーを eV 単位で入力する。

BL-10Bの場合は続けて以下の様に channel-cut 結晶の溝幅を指定する。

Channel	width of	the monochromator/mm df:	9.5
{ / }			

以下、共通入力部へ

<u>共通入力部</u>

以下の部分はどの入力方法を選択した時も共通して入力する。

dwell time (1)--(4)/SEC DF: 1.0 1.0 1.0 1.0 {0.5,1.0,2.0,3.0}

各ブロックでの1点当りの測定時間を入力する。測定時間の最小値は 0.1 秒であり、その**有効** 桁数は一桁である。従って 1.5 秒や 15.0 秒等は指定できない。この様な入力をした時はエラー メッセージが出て、再入力を求める。CAMAC のスケーラ、タイマーを使用している時はこの限 りでない。

```
present angle/deg
{15.234}
```

現在のモノクロメーターの角度を入力する。

入力値とエンコーダーの読みの差が 0.00015 °より大きい時は次のエラーメッセージが出る。 再度入力が促進されるので正しい値を入力する。

Your order is different from the encoder. Correct your order or adjust the encoder.

入力値が受け付けられるとこれまでの入力を確認するためのデータが表示される。日時、蓄積電 流値、暗電流値については前回測定時の値が入っている事があるが、測定開始までに入力される ので気にしないこと。

Ring :	2.5 GeV	.0 mA -	.0 m	A		
Mono :	SI(111)	D= 3.1	3551 A	Initial	angle= 15	.23400 deg
BL12C	Transmissic	on(2) R	epetitio	n= 1	Points=	573
Param fi	ile : A:CUKEX.	PAR a	ngle axi	s(1)	Block=	4
Block	Init-ang	final-an	g	Step/deg	Time/s	Num
1	13.49000	12.7900	0 -1.000	000E-2	. 50	70
2	12.79000	12.5700	0 -1.000	000E-3	1.00	220
3	12.57000	12.0400	0 -3.000	000E-3	2.00	177
4	12.04000	11.3100	0 -7.000	000E-3	3.00	106
Offset o	of Ch 2 - 4/se	c :	.00	.00	.00	
lt will	take 18.4 m	nin.				
If OK, 1	type 1					

READ PARAMETER FILE 以外からこのルーチンに入った時は

Make a parameter file ? yes(1)
{1}

今作ったパラメーターを何回か使う時は1を選択してパラメーターファイルを作る。この時、以下のようにパラメーターファイル名を尋ねてくる。

```
===== PARAMETER FILE =====
File name (#############)
{CUKEX.PAR}
```

この例では測定用パラメーターは CUKEX.PAR という名のパラメーターファイルに保存される ので、次回からはこのパラメーターファイルからパラメーターを入力することが出来る。拡張子 は PAR または P 等とすると実験終了後のバックアップ、削除が容易で望ましい。パラメーター ファイルは HD(ドライブ A)のカレントディレクトリ(A:¥USER)上に作られる。実験終了 時には各自が作ったパラメーターファイルを HD から消去すること。

9.9 測定用サブルーチン

以上で測定条件の設定が出来たのでいよいよ測定にはいる。測定用サブルーチンを選択すると、 以下のメッセージが出るので、測定の繰り返し回数を入力する。ディスク容量の許す範囲で最大 1000回まで可能。

```
number of repetition df: 1
{/}
```

次に、後で試料の区別をするための試料名を入力する。最大半角 80 文字であり、データ解析に 用いる計算機が許せば、小文字、日本語等も入力可能である。後で出てくるデータファイル名と 区別すること。

```
sample name (A80)
{Cu foil 6 micron }
```

次に検出系のオフセットの測定を行う。この時点までに電流増幅器の利得を決めておかなけれ ばならない。オフセットは電流増幅器の利得によって変化するので、利得を変えた場合は再測 定が必要である。測定中に変更することも可能であるが、レンジ間でデータがつながらないこと もあり、避けるべきである。以前は DARK(暗電流)と称していたが、offset の方が正確な表現 であるため、変更した。

```
Input offset
1--manual input
2--measure offset
{2}
```

1を選択すると以下のようにオフセット値の入力を促進してくる。通常、前と同じ条件で測定し、 オフセット値を再測定する必要の無い時に用いる。

```
--- Offset/cps ---
signal channels
2 -- 3 25.40 46.30
{/}
```

2を選択すると、以下の様にシャッター(DSS)を閉じることを要求してくる。

```
== Close shutter please ==
If OK, type 1
{1}
== Now measuring offset for 30. sec ==
```

シャッターを閉めて、1 を入力すると最大測定時間の 10 倍または 10 秒の長い方の時間オフセットを測定し 1 秒当りの値を求める。但し、60 秒を越える場合は 60 秒の測定とする。この例では第三ブロックで 1 点当たり 3 秒のデータ積算を指定しているので、オフセットは 30 秒間測定する。

 I_0 の信号が-0.1V以下(絶対値で 0.1V以上)の場合はシャッターを閉め忘れが疑われ、再度 上記のメッセージを示す。 オフセットの測定が終るとシャッターを開けることを要求してくる。シャッターを開け忘れ ないこと。

== Open shutter please ==

この後最終的な測定条件が表示される。最後の部分はスケーラーの各チャンネルに入力する信号のモードである。Expert mode ではこの時点までに各チャンネルに入力する信号のモードが決まっている必要がある。Novice mode ではこの後で、検出法を指定する。

```
Ring: 2.5 GeV
                    .0 mA -
                               .0 mA
Mono :
                    D= 3.13551 A
       SI(111)
                                    Initial angle= 15.23400 deg
BL12C
        Transmission(2) Repetition= 1
                                            Points= 481
Param file : A:CUKEX.PAR
                        angle axis(1)
                                           Block=
                                                     4
Block
        Init-ang
                    final-ang
                                   Step/deg
                                              Time/s
                                                        Num
                    12.79000 -1.000000E-2
         13.49000
                                               .50
                                                        70
   1
                    12.57000 -1.000000E-3
   2
         12.79000
                                              1.00
                                                        220
         12.57000 12.04000 -3.000000E-3
   3
                                             2.00
                                                        177
   4
         12.04000
                    11.31000 -7.000000E-3
                                              3.00
                                                        106
Offset of Ch 2 - 4/sec :
                         31.60
                                   25.40
                                             0.00
--- Mode for each channel ---
1:10, 2:trans., 3:fluo., 4:e-yield, 5:other, 0:ignore
ch:mode ch:mode ch:mode ch:mode
                                     ch:mode
 1: 0
          2: 1 3: 2
                             4: 0
```

ピエゾ素子を用いて二結晶の平行性を測定中制御出来る(tune optimization)設定となっている場合は tune optimization を使用するか尋ねてくる(結線については 4.7.5 参照)。この設定は BL-7C、 12C で Si(311)結晶を用いる場合に使い、通常は使用不能に設定してある。Tune optimization では 各データ点毎に Δ 0を変えて 5 点の I₀ を ADC を用いて測定し、そのデータを二次式にフィット して rocking curve の peak top を求めている。このため、1 スペクトル当たり数分余分に時間が掛 かる。

Tune optimization を使用する場合は以下の様に尋ねてくる。

Use PZT optimization: yes(1)
{1}
PZT readings at peak top and at desired position by micron
Set PZT at the desired position
{6.8,6.8}
STEP/MICRON DF: .03
{/}

分かり難い表現で恐縮だが、まず I_0 を最大強度に合わせた時のピエゾコントローラーのミクロ ン単位での読みと、目的の tune (detune)に合わせた時の読みを入力する。Rocking curve のピ ークトップで測定する場合は同じ値を入力すれば良い。次に tune を 5 点変える時の変化量を入 力する。通常こちらはデフォルト値で良い。

次に novice mode の場合は測定のモードを指定する。吸収法の時は ln(I₀/I) が、他の時は I/I₀

が求められ、CRT に表示される。

```
Type of measurement
Transmission(2), fluorescence(3), e-yield(4) df:
                                                    2
{/}
```

Expert mode の場合は、既に各チャンネルの測定モードは設定されているので、どのデータを CRT 上に表示するかを指定する。

Display datum: a channel(2-4)/10 {3}

CRT には指定したチャンネルの値を Io で割った値が表示される。従って、Io に使用しているチ ャンネル(この例では ch 2)を指定すると1しか出なくなる。

以上で、データファイル名以外の全ての設定が終わり、いよいよ測定の開始となるが、ここで、 レーザープリンタへの出力をするか否か、測定を開始するか否かを指定する。

> Start measurement: w.LBP out(1), w/o.LBP out(0), NO(others) {1}

ここで、1 (with LBP out)を選択すると測定終了後、測 定条件とスペクトルがレーザープリンタに打ち出される (図 9.9.1)。これが通常の選択である。

2(without LBP out)を選択すると、測定終了後レーザー プリンタには何も出力されない。連続測定をしていて、プ リンタの障害(紙詰まり、紙切れ、通信エラー)等によっ て測定が中断することを嫌う場合、印字されたスペクトル が不要な場合に選択する。

これら以外の数値を指定すると、測定を開始せずにメイ ンメニューに戻る。試料名を入力し間違えた場合等に利用 する。

この後、いよいよ測定開始となるが、I₀の強度が-0.1V 以上(0~-0.1Vの間)の時は、シャッターの開け忘れが 疑われ、以下のメッセージが出る。通常はシャッターを開

> *** Too weak 10 *** Start(1), not start(others)

開始する。

B:CE[6]]. D L. 307 1. 307 8480. 1

B:CU1611.D 01.06.23 01:09 - 01.06.23 01:21

Plot channel is \$

図 9.9.1 測定終了後の LBP 出力 けて I₀の信号強度を確認して測定を開始する。特殊な事 例。測定条件とµt、I₀が出力され 情があり信号が弱い場合は 1 を入力するとそのまま測定 る。

入力値とエンコーダーの読みの差が0.00015°より大きい時は以下のエラーメッセージが出る。

Your order is different from the encoder. Correct your order or adjust the encoder. present angle/deg {15.234}

測定ループに入ると次のようにデータファイル名を尋ねてくる。

```
===== DATA FILE =====
File name (##############)
{CU001.D}
```

繰り返し測定の二回目以降はこのメッセージを出さずに、自動的に名前が付けられる。繰り返 し測定を指定した場合は、データファイルの拡張子は 1 回目の測定ではユーザーの入力通りで あるが、 2 回目以降は 001 から順に増大してゆく(即ちこの例では CU001.D, CU001.001, CU001.002 となる)。従って、繰り返し測定をする場合は数字のみで構成される拡張子を用いな いことを勧める。

データファイル作製時に同一名のファイルが既に存在する時は次のエラーメッセージを出す。

```
*** The file already exists ! ***
Overwrite(1), change file name(others)
{2}
```

同名の旧ファイルに上書き(旧ファイルを消去)して良いときは1を入力すると次へ進む。消去 してはいけない時は1以外の数値を入力すると再度ファイル名を尋ねてくる。また、データファ イル作製時に FD が一杯で、ファイルを作る余地が無いときは次のメッセージを CRT 及びプリ ンターに出力し、データを HD(A:)にセーブする。この場合上記の様な同一ファイル名のチェッ クは行わないので注意が必要である。なお、HD をデータディスクに指定していて、ディスクフ ルになった場合の処置は用意していない。通常こういった状態は発生しないはずである。 測定が終了した時点でフォ - マット済みの FD に複写し、HD 上のデータファイルを消去するこ と。

*** Disk full ! Temporary file is made in disk A: ***

この後、測定が始まる。測定中は CRT 上にµt(緑色)及び I₀(白色)がグラフで示されると 共に、測定点のデータ(正確には 1 点前)が数値で表示される。エネルギー較正を行う時は目 的のデータ点の番号を控えると後でやり易い。CRT 上のスペクトルはオーバーフロー、アンダ ーフロー時にはスケールが変更される。

ースペクトルの測定が終った時点で全データが FD にセーブされ、測定条件等とスペクトルが レーザープリンタに出力される(図 9.9.1)。その後、次の様なメッセージを出力する。繰り返し 測定を指定した時はこのメッセージを出さずに自動的に測定を繰り返し、最後の測定が終了した 時点でこのメッセージを出す。この前で処理が止まった場合はレーザープリンタの障害が考えら れる(紙切れ、紙詰まり等)ので点検をすること。

Printing to LBP
SELECT RETURN MODE
1 STOP HERE
2 RETURN TO THE INITIAL ANGLE
3 GO TO ANOTHER ANGLE
{2}

これは測定終了後にモノクロメーターの Bragg 角を何処へ持って行くかを尋ねている。即ち、 1を選択するとそこに止まり、2を選択すると測定開始時にいた角度(9.8 節 共通入力部で指 定した present angle または測定開始時に入力した角度)へ戻る。3はそれら以外の角度へ送 りたい時に用いる。この場合以下の様なメッセージを出して行き先の角度を尋ねるので送り先の 角度を入力する。

Destination angle/deg {12.00}

目的の角度に送られたことを確認できるとメインルーチンに戻る。

9.10 測定中の測定条件の変更等

いくつかの条件は測定中にキーボードのスペースキー、英数字キーを押す事によって変更でき る。特殊なキー(ファンクションキー、STOP、COPY、RETURN 等)を押した時の応答は保 証できない。キーを押すとその測定点の測定を完了し、次の点の測定を開始する前に次の様なメ ッセージを出す。先に押したキ - の文字がエコ - バックされた時はその文字を消去してから番号 を入力する。

NUM	MOE	DE		
1R	ESTART	Г		
20	HANGE	Y-SCALE		
30	HANGE	GRAPH		
40	HANGE	OFFSET		
50	HANGE	DWELL TIM	Ξ	
60	HANGE	NUMBER OF	REPETITION	
70	HANGE	LP OUTPUT	MODE	
80	UIT			
{1}				

RESTART は測定を再開する時に用いる。ハッチ内の試料の状態を観察し終った時等に用いる。

CHANGE Y-SCALE は CRT 上のスペクトルの縦軸のスケールを変更したい時に用いる。

```
Which line; ut(1) or IO(2)?
{1}
```

まず、Y 軸を変更する変数を選択する。ut は μ t、I0 は I $_0$ の意。次に Y 軸下端(YMIN)と上端(YMAX) の値を入力する。

INPUT NEW YMIN AND YMAX DF: 1.210 2.464 {1.2,3.0}

これでスケールが変更され、測定が続けられる。

CHANGE GRAPH は表示するデータを変更する場合に用いる。Ch3 に蛍光のデータ、Ch4 に透過の データを採りながら、もう一方のデータを見たい場合等に用いる。従って、novice mode で使用 することはない。

Present display channel is 3 23:sum data {4} CHANGE OFFSET は電流増幅器のオフセット値を変更するときに用いる。利得を変更した時やオ

```
Input offset
1--manual input
2--measure offset
{1}
```

フセット測定に間違いがあった場合が該当する。但し、利得を変更するとスペクトルが不連続に なる可能性があるのでこの様な事が必要無い様に条件を設定すべきである。

以下、9.9節と同様にしてオフセットを設定する。

```
=== offset is changed at 431 ===
IF OK, TYPE 1
{1}
```

1 以外の数値を入力すると再度、Input offset に戻る。オフセット変更の情報は測定終了後プリ ンタにも出力される。

CHANGE DWELL TIME はデータ蓄積時間を変更するときに用いる。

INPUT NEW DWELL-TIME/S DF: 1. 2. 3. {1.,1.,2.}

全体で4ブロックの測定の第二ブロックでこれを選択するとこの様に 2~4 ブロックの3つの測 定時間を変更できる。測定時間を変更した時は測定終了後その旨プリンターに出力される。

CHANGE NUMBER OF REPETITION は繰り返し測定回数を変更する場合に用いる。

```
INPUT NEW NUMBER OF RETETITION THIS RUN IS 3/ 5
{10}
```

この例は5回繰り返し測定の3回目に、繰り返し回数を10回に変更した例である。

CHANGE LP OUTPUT MODE はプリンターへの生データ出力モードの変更に用いる。

w.LBP out(1), w/o.LBP out(0) DF: 1
{0}

これはプリンタへの出力を取り止めた例である。

QUIT は途中で測定を止めたい時に用いる。安全を期すために本当に止めて良いか再度確認をしてくる。測定を止める時は 975 を入力する。

ARE YOU SURE ? TYPE CODE :QUIT(975) CONTINUE(OTHERS)

測定を止めた時はそこまでのデータを FD にセーブして次の行き先を尋ねてくる(9.9 節の最後 を参照)。

9.11 データ入出力サブルーチン

ここでは主にデータの出力方法について記す。測定用ソフトのメインルーチンで OUTPUT を 選択すると、このデータ入出力ルーチンに入る。このルーチンに入ると次の様に試料名を表示し た後メニューを表示する。

Cu foil 6 micron	
NUM MODE	
1 CD OUTPUT	
2 LP OUTPUT	
3 GD OUTPUT	
4 PLOT OUTPUT	
5 DATA INPUT	
6 RETURN TO MAIN	
{3}	

CD OUTPUT は測定条件及び測定データを CRT に文字出力する。 LP OUTPUT は測定条件及び測定データをレーザープリンターに文字出力する。 GD OUTPUT は測定データを CRT 上にグラフィックス出力する。 PLOT OUTPUT はスペクトルをレーザープリンターにプロット出力する。 DATA INPUT は FD からデータを入力する。 PETYPN TO MAINはデータ出力用サブルーチンからメインルーチンに戻る。 測定直後にデータ出力をする時は FD から再度データを入力する必要はない。

9.11.1 文字出力

測定条件を出力した後、データを数値の形で CRT(CD OUTPUT)またはプリンター(LP OUTPUT)に出力する。CRTに出力する場合、1回に10行程度が適当である。

RANGE OF PRINT DATA DF: 1 -- 481 0,0 : PRINT NO DATA {20,50}

この例では 20 点目から 50 点目のデータを出力する。どちらかに 0 を入力するとデータを出力 しない。XANES スペクトルから角度較正を行う場合等に使用する。

9.11.2 グラフィックス出力

このルーチンを選択すると以下の様なメッセージを出し、出力すべきデータを尋ねてくる。

output IO(1), I(2), ut(3) df:3 {/}

I₀やI を出力するときは各々 1,2 を指定する。ut はμt を意味する。 次に横軸の選択をする。

```
SELECT ABSCISSA: ANGLE(1), ENERGY(2) DF: 2
{/}
```

角度軸で表示したい時は1 を、エネルギー軸で表示したい時は2 を指定する。横軸の指定が終ると横軸の出力範囲を指定する(角度の時は度、エネルギーの時は eV 単位で指定する)。

ABSCISSA RANGE DF: 8475.430 10085.700 {/}

XANES 部のみを拡大して出力したい時等は必要な領域を指定する。レーザープリンターに印刷 してスペクトルの比較を行うときは軸の範囲を一定にした方が便利である。 横軸の範囲の指定が終ったら、縦軸の範囲の指定を行う。

Y-MIN = 1.103 Y-MAX = 3.369 SCALE SELECTION: AUTOMATIC(1), MANUAL(2) {2}

AUTOMATIC を選択した時は適当にスケーリングをして図を描くが、MANUAL の場合は次の 様に領域を指定しなければならない。

```
INPUT Y-MIN AND Y-MAX {1.0,3.4}
```

CRT 出力の場合、描画が終了すると以下の様に尋ねてくる。

EXIT GRAPHIC MODE (ANY NUMBER)
{1}

数字を入力すると本章の始めのメニューに戻る。レーザープリンターへ出力する場合は、CRT にスペクトルを描画した後、以下の表示がされる。レーザープリンターに出力する場合は1を、 しない場合は1以外の数値を入力する。

PLOT OUTPUT MODE/ 1 -- PLOT THIS SPECTRUM OTHERS -- NOT PLOT DF: 1 {/}

9.11.3 データ入力

以前に測定したデータを上記の方法で出力する時は FD からデータを入力する必要がある。プログラム起動時に指定したディスクドライブから読み込むことを原則とする。

指定したファイルが当該ドライブに見つからない場合は、

と出るので、ファイル名を変えて入力するか、入力ドライブを変更する場合は##CHANGE.DRV と入力する。データを入力して試料名を表示した後、本章の最初のメニューに戻る。

9.12 データフォーマット

旧制御ソフトのデータフォーマットと互換性はないが、データファイルの最初の 5 バイトを 識別子としてある。従来の HX6814 や MDHX01 で作成したファイルではここに、2,3,4,12,13,14 等の数字が測定モードを反映して記されている、新しいソフトでは 9809 としてある。測定モー ドは各データチャンネル毎にセーブしてある。以下、通常のデータに関係するデータフォーマッ トをまとめる。

```
IFCD=9809
      WRITE(IOP, 100) IFCD, BL
  100 FORMAT(1H , I5, 5X, 'KEK-PF', T21, A5)
      WRITE(IOP,101) FN,YMD(1),YMD(2)
  101 FORMAT(1H ,A14,2X,A14,' - ',A14)
      WRITE(IOP, 102) SAMP
  102 FORMAT(1H , A80)
      WRITE(IOP,103) ERING,CRING(1),CRING(2)
  103 FORMAT(1H ,'Ring : ',F5.1,' GeV',2X,F6.1,' mA - ',F6.1,' mA')
      WRITE(IOP, 104) XTAL, D, PANG
  104 FORMAT(1H , 'Mono : ', 3X, A10, 4X, 'D= ', F8.5, ' A', 4X,
     + 'Initial angle=',F9.5,' deg')
      WRITE(IOP, 105) BL, CMODE(MODE), MODE, IREP, NPT
  105 FORMAT(1H , A5, 4X, A13, '(', I2, ')', 3X, 'Repetition=', I3, 5X,
     + 'Points=', 15)
С
C ---- parameters for measurement
      IF(IAE.EQ.1) THEN
      WRITE(IOP, 107) PFN, IAE, NBLK
  107 FORMAT(1H , 'Param file : ', A14, 2X, 'angle axis (', I1, ')', 5X,
     + 'Block =', 15//
     + 'Block',6X,'Init-ang',2X,'final-ang',5X,'Step/deg',5X,
     + 'Time/s',7X,'Num')
      WRITE(IOP, 109) (K, BLOCK(K), BLOCK(K+1), STEP(K),
     + RTIME(K), NUM(K), K=1, NBLK)
  109 FORMAT(1H , I5, 5X, 2F10.5, 1PG13.6E1, 0PF11.2, I10)
С
      ELSE IF(IAE.NE.1) THEN
      WRITE(IOP, 108) PFN, IAE, NBLK
  108 FORMAT(1H , 'Param file : ', A14, 2X, 'energy axis(', I1, ')'5X,
     + 'Block =', 15//
     + ' Block', 6X, 'Init-Eng', 2X, 'final-Eng', 5X, ' Step/eV', 5X,
     + 'Time/s',7X,'Num')
      WRITE(IOP, 112) (K, BLOCK(K), BLOCK(K+1), STEP(K),
     + RTIME(K), NUM(K), K=1, NBLK)
  112 FORMAT(1H , I5, 5X, 2F10.2, F13.2, F11.2, I10)
```

```
END IF
С
C ---- data
      IF(ICA.EQ.1) WRITE(IOP, 166) ICA, NDCH
  166 FORMAT(1H , 'CAMAC(', I2, ')', 5X, 'NDCH =', I2)
      IF(ICA.LE.O) WRITE(IOP, 167) ICA, NDCH
  167 FORMAT(1H , 'Ortec(', I2, ')', 5X, 'NDCH =', I2)
      IF(ICA.LE.0) GO TO 2100
C ---- for CAMAC scaler
      WRITE(IOP, 160) (J, J=1, NDCH), (J, J=1, NDCH)
      WRITE(IOP, 161) (MODEM(J), J=1, NDCH), (MODEM(J)+100, J=1, NDCH)
      WRITE(IOP, 162) (OFFS(J, 1), J=1, NDCH), (OFFS(J, 2), J=1, NDCH)
      DO 43 I=1,NPT
   43 WRITE(IOP,163) ANGM(I), ANGE(I), DWT(I), (IDTM(I, J, 1), J=1, NDCH),
     + (IDTM(I,J,2),J=1,NDCH)
      GO TO 2101
C ---- for Ortec 974
 2100 WRITE(IOP, 160) (J, J=2, NDCH)
      WRITE(IOP, 161) (MODEM(J), J=2, NDCH)
      WRITE(IOP, 162) (OFFS(J, 1), J=2, NDCH)
      DO 44 I=1,NPT
   44 WRITE(IOP,163) ANGM(I), ANGE(I), DWT(I), (IDTM(I,J,1), J=2, NDCH)
 2101 WRITE(IOP, 164) CHAR(26)
С
  160 FORMAT(' Angle(c) Angle(o) time/s',44110)
  161 FORMAT(6X, 'Mode', 9X, '0', 9X, '0'44110)
  162 FORMAT(4X, 'Offset', 9X, '0', 9X, '0', 44F10.3)
  163 FORMAT(2F10.5, F10.2, 44110)
  164 FORMAT(1A)
```

変数名	書式	変数の意味
IFCD	I5	フォーマット識別コード 9809
BL	A5	ステーション名 (BL12C、B
FN	A14	データファイル名
YMD	A14	日時、(1)は測定開始時、(2)は
SAMP	A80	コメント(試料名)
EDINC	EF 1	雨フ(四雨フ)ビ ノのエラリキ

BL	A5	ステーション名 (BL12C、BL10B 等)
FN	A14	データファイル名
YMD	A14	日時、(1)は測定開始時、(2)は測定終了時
SAMP	A80	コメント(試料名)
ERING	F5.1	電子(陽電子)ビームのエネルギー GeV 単位
CRING	F6.1	蓄積電流、(1)は測定開始時、(2)は測定終了時 mA 単位
XTAL	A10	分光結晶面 SI(111)、SI(311)等
D	F8.5	分光結晶の格子面間隔 Å 単位
PANG	F9.5	測定開始前の現在角 度単位
CMODE	A13	測定モード Transmission, Fluorescence 等
MODE	I2	測定モードのコード 2:透過法、3:蛍光法、4:電子収量法
IREP	I3	測定の繰り返し回数
NPT	I5	1 測定中のデータ点数
PFN	A14	使用したパラメータファイル名

が入っている

IAE	I1	パラメータの単位 1:角度、 2:エネルギー
NBLK	I5	ブロック数
K	15	ブロックの番号
BLOCK(K)	F10.5	ブロックの区切りの角度(度単位)またはエネルギー(eV 単位)
STEP(K)	1PG13.6E1	ブロック内のデータ点毎の送り角度。エネルギー単位の場合は F13.2
RTIME(K)	F11.2	ブロック内の測定時間(途中で変更した場合は最終的な指定のみ)
NUM(K)	I10	ブロック内のデータ点数
ICA	I2	測定に用いたスケーラ 1:CAMAC、0:ORTEC 974、-1:novice mode
NDCH	I2	測定に用いたデータチャンネルの数
MODEM(J)	I10	J チャンネルの測定モード 1:I0、2:透過、3:蛍光、4:電子収量、5:そ
		の他
OFFS(J)	F10.3	J チャンネルのオフセット/sec
ANGM(I)	F10.5	I 点目の計算上の角度 / 度
ANGE(I)	F10.5	I 点目のエンコーダで測定した角度 / 度
DWT(I)	F10.2	I 点目の測定時間/s
IDTM(I,J,1)	I10	I 点目の J チャンネルのカウント数
IDTM(I,J,2)	I10	I 点目の J チャンネルに対応する ICR のカウント数。但し、I0 に対応
		する配列はプリアンプのリセット回数。多素子 SSD を使用しない場合
		は適用されない。

注意事項

測定を途中で止めたときは NUM(I) NPTとなる。最後まで測定した時は等号で結ばれる。 FN にはドライブ名も付いている。

将来、システムの変更等の為フォーマットを変更する可能性がある。

実際の出力例(測定データの頭まで)を図 9.12.1 に示す。

これまでPFではいくつかのデータフォーマットを使用してきた。その主なものは

1 初期の BL-10B で、SORD 製パソコン時代のフォーマット

2 BL-7C、6B、12C、10B 等で使用した HX6814 形式

3 BL-12C の多素子 SSD 試験期に用いた MDHX01 形式

4 最近の標準フォーマットとなっている MDHX02 形式。

これらの間及びリガク製解析ソフト REX のフォーマット変換を行うソフトを PFXAFS ホーム ページ上で公開している。

9809 KEK-PF BL12C G:CU001.D 00.10.31 13:37 - 00.10.31 14:00 Cu foil 6 micron Ring : 2.5 GeV 360.9 mA - 359.0 mA Mono : SI(111) D= 3.13551 A Initial angle= 12.7189 deg Transmission(2) Repetition= 1 BL12C Points= 573 Param file : A:cukex.par angle axis (1) Block = 4 Block Init-ang final-ang Step/deg Time/s Num 13.49000 12.79000 -1.000000E-2 .50 70 1 2 12.79000 12.57000 -1.000000E-3 1.00 220 12.57000 12.04000 -3.000000E-3 3 2.00 177 12.04000 11.31000 -7.000000E-3 4 3.00 106 NDCH = 3Ortec(-1) Angle(c) Angle(o) time/s 2 3 Mode 0 0 1 2 Offset 0 0 134.300 67.900 13.49000 13.49000 .50 301835 168960 13.48000 13.48000 . 50 301966 169567 13.47000 13.47000 .50 301693 169947 13.46000 13.46000 .50 301253 170241 13.45000 13.45000 .50 300745 170494

図 9.12.1 データの出力例

9.13 エラーメッセージ

これまでに説明しなかったいくつかのエラーメッセージをまとめる。

*** Fatal trouble occurred in the monochromator or encoder.

Program is terminated.

You should call the person in charge of this station.

- PANG = 12.7259 RHDN= 11.7249
- 原因:パルスモーターが動いていない/脱調した。エンコーダーに異常が生じた。通信障害が 発生した。
- 対策:担当者を呼ぶ。重故障であるので、通常角度の較正からやり直す必要がある。

*** Out of limit !! ***

原因:許されない角度ヘモノクロメーターを送ろうとした。

対策:許される範囲内の角度(表 4.5.1 参照)を指定する。

***** LIMIT DETECTED ***** 原因:パルスモーターがリミットを検出した。 対策:担当者を呼ぶ。 *** TOO MANY DATA POINTS max=1000 ****

原因:データ点数が1000点を越える様なパラメータを指定した。 対策:測定パラメーターを修正してデータ点数を減らす。

*** ILLEGAL ORDER ***

原因:許容されていない数値を選択した。

対策:再入力する。

*** ABNORMAL IO and/or I ***

CONTINUE(0), QUIT(1)

- 原因: I₀のカウント数がオフセット差引後 10 以下であった。または透過法の測定で、その他のチャンネルのカウント数がオフセット差し引き後 0 以下であった。但し蛍光 XAFS 測定時は I₀のみをチェックしている。ビームダンプ、DSS の開け忘れ、信号線の断線等が考えられる。
- 対策:信号を数えられるようにして0を選択するか、1を選択して測定を止める。この場合も ここまでのデータは FD にセーブされる。

第10節 蛍光XAFS法

10.1 **蛍光検出法の原理**

蛍光X線を検出して微量分析をする様に蛍光X線を検出することによって XAFS 信号を求め る方法が蛍光 XAFS 法である。信号量の算出は蛍光X線分析で用いられているのと同様に試料 を入射X線に対して45°傾け入射光と直交方向で検出した場合以下のようになる[14]。

 $I_{f} = I_{0} \quad (/4) \quad \mu_{x}(E) \{1 - \exp[-\mu_{t}(E) - \mu_{t}(E_{f})]d\} / (\mu_{t}(E) + \mu_{t}(E_{f})) \quad (11.1.1)$

ここで I_0 は入射 X 線強度、 は蛍光量子収率、 は検出器の張る立体角、 $\mu_x(E)$ はエネルギー Eの X 線に対する目的原子の線吸収係数、 $\mu_t(E)$ は入射光に対する試料の全線吸収係数、 $\mu_t(E_i)$ は 蛍光 X 線に対する線吸収係数、 d は試料の厚さである。詳細は元報を見て頂くとして、結論的に は 濃度が高くて厚さが薄い場合、 濃度が低くて厚い場合には蛍光の信号は試料中の目的原子 の吸収係数にほぼ比例する。どの程度から適用できるかという概算を銅についてすると につい ては 1000Åの金属薄膜、 については数 mm 厚の 0.01 mol dm⁻³の水溶液ということになろう。 ここで記した濃度は均一系を考えており、米飯上の胡麻塩の様な場合は平均的な濃度が低くても、 ローカルには高濃度で厚い試料と云うことになる。

透過法と蛍光法のどちらが良い S/N を得られるかについては文献 15 を一読していただきたいが、かなり低濃度でも条件を整備して透過法で頑張った方がよいデータが採れるという話もある。 大雑把に言って $\epsilon\Omega/8\pi > \mu_x/\mu_t$ で蛍光法が S/N 的に有利になる。

図 10.1.1 に 0.01 mol dm⁻³の銅水溶液を透過法と蛍光法で測定したスペクトルを示す。この 程度の濃度になると、透過法では溶媒によるバックグラウンド吸収が大きくなり、解析に任意性 が出易くなる。ただ、このスペクトルからでもχを抽出して Fourier 変換をする事により Cu-O に 由来するピーク程度は容易に取り出せる。単純に濃度が低いから蛍光法がベターであるという訳 ではなく、組成によってどちらが良いかは異なってくる。同じモル濃度であっても、銅ではなく 銀の水溶液を測定する場合は透過法の法が有利である。



図 10.1.1 0.01 mol dm⁻³の銅水溶液を透過法(左)と蛍光法(右)で測定した XAFS スペクトル。蛍光 XAFS は fluorescent ion chamber detector (Lytle detector)を用い、通常の 45°配置で測定した。

10.2 **測定上の注意**点

少なからぬユーザーが蛍光 XAFS は透過法の superset であるかの様に勘違いをされているが、 蛍光法は透過法ではどうしても測定できない試料に対する緊急避難だと考えるべきである。また 表面敏感という誤解も一部にあるが、X線の試料への侵入深さはµm 以上であり、バルクの情報 を与える。透過法と異なって特に注意しなければならないことは、

1. 適用できる試料の濃度、厚さの制約がきつい。

2. 妨害信号を取り除かないと S/B が改善されない。

3. バックグラウンドの引き方に任意性が大きい。

等である。

最初のケースについては先にも触れたが、通常の透過法の感覚で参照試料を用意することが出来ない事を意味する。もしこの様な事をすれば少なくとも振幅(配位数や温度因子)に関する情報は全く信頼できないものとなるし、散乱因子の k 依存性情報(散乱原子種に関する情報)も怪しくなる。厚さの異なる銅箔の吸収端を蛍光法で測定したスペクトルを透過法で測定したものと比較して図 10.2.1 に示す。残念ながらここに示したスペクトルは透過法のもの以外はすべて前述の条件からはずれ、正しくない。また蛍光×線分析法の分野では吸収補正の方法等がかなり議論されているのに対し、蛍光 XAFS の分野ではこの辺りの議論が不足している。補正をしようにも、吸収端付近での正確な吸収係数のデータが無いために補正できないと言う方が正確かも



 $b \sim d d p f f = 1$ 金元次、 d = 3 3 d = 1 3 f = 1 2 f = 1 3 f = 1 2 f = 1 3 f

知れない。

二番目の妨害信号は 散乱 X 線と 共存原子の蛍光 X 線の二種類に大別できる。例として希薄 な銅水溶液試料に単色 X 線が入射した場合を取り上げて説明すると、Cu Kα線、Cu Kβ線の他に 弾性散乱(Thomson 散乱) 非弾性散乱(Compton 散乱、Raman 散乱)が出、散乱 X 線の強 度は蛍光 X 線より強いことが多い。従って散乱 X 線を取り除く工夫をしなければ S/B 比の高い スペクトルを得ることは出来ない。次に鉄隗中の微量の銅を考えると、先と同様に Cu Kα線、Cu Kβ線、弾性散乱、非弾性散乱が出るが、その他にマトリックスの鉄から Fe Kαと Fe Kβ線が出て き、その強度は目的とする Cu の信号よりはるかに強くなる。目的の蛍光 X 線強度を S、散乱や 妨害蛍光を含めてバックグラウンド強度を B とすると、S/N = S/(S+B)^{1/2} と表される。希薄試料 では B > 200S の場合も少なくないが、この場合バックグラウンドを削減しないと、いくら長時 間データを蓄積しても S/N が有効に改善されない。この他にも見落としがちであるが、高次光 の弾性散乱、非弾性散乱や高次光に依って励起された蛍光 X 線が混入していることもある。例え ば銅試料中の不純物の鉄を測定しているにも係わらず、高次光が銅の蛍光 X 線を励起してしまう 場合がある。

散乱×線を防ぐにはまず放射光の偏光方向を考え、散乱の少ない方向(水平面内で入射×線と 直交方向)で蛍光×線を検出することである。次に蛍光×線と入射×線のエネルギーの間に吸収 端を持つフィルターを用いると有効である。原理は×線回折で使用するβフィルターと同じであ る。蛍光×線はこのフィルターを透過するが、弾性散乱×線の透過率は低くなる。この時、フィ ルターを透過した散乱×線の強度が蛍光×線と比べて十分に小さくないとフィルターの XAFS を反映した信号が検出器に入るはずである。またこの場合、フィルター自体から蛍光×線が出る ので、これを立体角的にできるだけ除くためにソーラースリットを用いる(フィルターからの蛍 光×線に対して検出器の張る立体角は必ず試料に対する立体角より大きい)。銅の希薄水溶液試 料から放出される×線のパルス波高分布を半導体検出器で測定した例を図 10.2.2 に示す[10]。 やや古いデータでエネルギー分解能が悪いが、特徴は分かろう。エネルギー的には次のようにな る。

(右ピーク)	弾性散乱		(Ni フィルターでかなり吸収される)
	Cu K-edge	8980 eV	
(右ピーク)	Cu Kß	8903 eV	(Ni フィルターでかなり吸収される)
	Ni K-edge	8332 eV	
(中ピーク)	Νί Κβ	8265 eV	(Ni フィルターから出る)
(中ピーク)	Cu Ka	8041 eV	
(左ピーク)	Νί Κα	7467 eV	(Ni フィルターから出る)

図 10.2.2(a)は試料から検出される X 線の波高分布であるが、銅の蛍光 X 線と比較して散乱 X 線(右側のピーク)が支配的である。ニッケルフィルターを入れると図 10.2.2(b)に示される様 に散乱 X 線は抑制されるが、ニッケルの蛍光(左側のピーク)が強くなる。発散スリットを入れることによってニッケルの蛍光も抑制される(図 10.2.2(c))。

PFでは Ti から Br の間に吸収端を持つ殆どのフィルター(μt=3、6)を備えているが、使用するエネルギーによっては適当なフィルターがないこともあるので注意を要する(第二部 5.3節)。PFに無いフィルターについては必要なユーザーが作り、共同利用に供する事を原則とする。作り方は文献 16 参照。また必ずしも Z-1 がフィルターの材質として最適とは限らないし、 軽原子の場合は物理的に適当なフィルターがないので、よく検討する必要がある。フィルターの候補を第二部 5.3節に記す。

最後にバックグラウンドについてであるがこれが充分に無視できる場合(プリエッジのµt が



図 10.2.2 純 Ge 半導体検出器で測定した波高分布(X線のエネルギー分布)

Comparison of the pulse height distributions measured with a pure Ge SSD. The sample is a 0.2 mmol dm⁻³ CuSO₄ aqueous solution. (a) without any filter nor slit,

- (b) with a nickel oxide filter whose μt is 6,
- (c) a slit is added to (b).

ほぼ0)はμt(preedge)をそのまま直線的に延長しても大して問題無いが、そうでない場合は数 式を仮定してバックグラウンドを引くことは殆ど不可能である。これにはまず先に記したフィル ターの XAFS を反映した弾性散乱信号が入っていること、Kβ線の寄与については吸収端前後で 滑らかに連続でない事が予想されるからである。実際、SSD を用いて測定した波高分布は入射 X線のエネルギーによって大きく変化している。また装置上の問題としては入射光子数がエネル ギーを変えても一定と仮定しても、エネルギーが上がるに従ってI。電離箱での検出効率が落ち、 信号が小さくなるのに、試料に入射する光子数は増大し、従って蛍光信号も大きくなることであ る。よくポストエッジに対してビクトリーン型や McMaster の吸収断面積にエネルギー依存性 が合うようにプリエッジのバックグラウンドを引いた例を見るが、問題があろう。希薄試料のバ ックグラウンドの引き方は、銅 XAFS 領域での水の蛍光 XAFS が構造を持つことを見ても極め て難しい事が理解できよう。

上記の様に実験、解析上注意すべき点は多いが、実用試料の XAFS 実験にとって蛍光 XAFS の感度は捨てがたいものである。

10.3 fluorescent ion chamber detector

これは大口径の電離箱で蛍光 X 線を検出しようというもので、上述のフィルターやソーラース リット、電流増幅器、再結合を防ぐための電源を含めて一体となっている[17]。全立体角の約1 割という大きな立体角をカバー出来、比較的安価である反面エネルギー分解能が無く、電離箱の 厚さが薄く高エネルギー域での測定には向いていない。開発者の名をとって Lytle detector と呼 ばれている。

構造は図 10.3.1 に示すとおりで電離箱の直径は約 82.5mm、厚さは 30mm である。窓はX 線の透過を良くするため薄いアルミマイラーであるので、ガスを交換するときは窓を必要以上に膨



図 10.3.1 fluorescent ion chamber detector (from ref. 19).

らませたり、破ったりしない様に注意を要する。通常の透過測定用の電離箱のつもりで purge すると圧力が上がりすぎて窓を破損する恐れがある。この窓が伸びる事はマイクロフォニック ノイズの増大を意味する。大きな容量性の信号源であり、かつ窓が薄く、他の電極もニッケル製 のメッシュ構造であるので振動やガス圧の変動について細心の注意を払う必要がある。

電離箱に印加している電場は 45V/15mm であり、エネルギーにも依存するが 10⁻¹¹A オーダー の信号に対しては充分な電場である。但し、10⁻⁹A オーダーになると不十分である。内蔵された 電流増幅器の利得の×1は Keithley427 の 10¹⁰V/A、×10 は 10¹¹V/A、×100 は 10¹²V/A に相当 する。内蔵電流増幅器のオフセットはR9と示されたトリマで調整する。但し内蔵アンプで使わ れているフィードバック用の抵抗は電源投入後のドリフトが大きいので、少なくとも2~3時間 はエージングする必要がある。また内蔵されているモジュール型増幅器は数万円のもので、 Keithley や Ithaco (DL Instruments)のものよりはるかに安価であることを考えると、これらの 電流増幅器を使った方が望ましい。各々の場合の接続図を図 10.3.2 に示す。

Lytle detector の弱点である高エネルギー域でも利用出来るように、光路長の長い蛍光 XAFS 用検出器をPFで製作し、共同利用に供している。この場合は電極にアルミマイラーを使用して おり、電極間隔は 25mm、光路長は 100mm であり、3 枚の電圧印加用電極と 2 枚の信号捕集用



図 10.3.2 蛍光 XAFS 用電離箱結線図 (左) Lytle detector 内蔵アンプを使う場合、(中) Lytle detector を Keithley 427 または DL Instruments 1211 アンプと接続して使う場合、(右) P F 製蛍 光 XAFS 用電離箱を使用する場合。

電極が交互に配置してある。再結合防止用の電圧には外部に 270V ないし 510V の積層乾電池を 接続して使用する。

10.4 シンチレーションカウンター

複数のシンチレーションカウンター(SC)を組み合わせた蛍光 XAFS システムも使われている [18]が、PF では1インチの NaI(Tl)の SC1本を使用している。このため試料に対する立体角は 小さい。パルス計数方式であるため、信号が弱い場合は直流測定に対してメリットがある。また エネルギーの比較的高い領域でも使える。SC のエネルギー分解能(ΔE/E)は25~60%程度であ るので、高次光は分離できるが、SCA を用いて信号と弾性散乱を分離することは出来ない。回 路構成及び主な使用上の注意は以下の通り。メーカーの取説を理解してから使用することを勧め る。また文献 23 には放射線計測についての分かりやすい説明が載っているので初心者は一読す る事。パルス計数方式は数え落しの補正が必要であるが、SC 用に使用しているアンプには入射 信号パルス数をモニターするための出力が無いため補正を行うことは出来ない。測定する信号に 対して、応答が十分直線的であるか確認して使用すること。検出器、回路が受ける信号は散乱や 妨害蛍光 X線を含めた全ての信号であり、目的の蛍光信号だけでは無いことに注意すること。

アンプ / SCA (大阪電波 MPS-1203A) についての注

- ・ 入力信号は 0~ -10V。
- ・ 出力は正のユニポーラ及び正で始まるバイポーラ波形。
- ・ オシロスコープで出力波形を見ながらポールゼロ調整を行うこと。
- ・ LLD は 0.05 10V の範囲で調整可能。
- ULD / Eの設定によって調整範囲は変わる。ULD にした時は 0.1 10V、 E にした時は 0.05 1.0V。
- ・ 利得は信号の大きさを見ながら決める
- ケーブルの接続、切り放し時は電圧を印加しない状態で行なうこと
- ・ 指定された極性、電圧を遵守すること
- SC にモノクロからの入射 X 線を直接入れないこと
- SCの中味はフォトマルなので衝撃を加えないこと
- ・ NaI(Tl)の結晶が割れるので温度衝撃を与えないこと
- ベリリウム窓(0.15mm)を破らないこと



10.5 半導体検出器

半導体検出器は通常 SSD(Solid State Detector)と呼ばれ、シンチレーションカウンターと比 べて高いエネルギー分解能を持っている(Mn Kaに対して 160eV 程度)。このため信号と散乱を 分離することも出来、生体試料を中心に多素子 SSD も使われている[19](1.7 節)。ここではハン ディタイプの単素子 SSD の利用について記す。素子の有感直径が 16mm の純ゲルマニウム検出 器で試料から 5cm の位置に置くと全立体角の 0.6%をカバーできる。また固体検出器であるので 検出効率も高い。回路構成及び主な使用上の注意は以下の通り。また文献 24 には放射線計測に ついての分かりやすい説明が載っているので初心者は一読する事。単素子の SSD、信号処理系 は数百万円に上るので、動作、調整法を十分に習熟した上で使用すること。

BL-12C には 19 素子の半導体検出器が設置されている。これは単素子の SSD と比べて高価で かつ壊れ易いものであるので、ユーザーを限定している。新たに利用を希望する方は担当者と相 談されたい。

・SSD に付属する取説を良く読み、理解すること
・ケーブルの接続、切り放し時は電圧を印加しない状態で行なうこと
・SSDにモノクロからの入射X線を直接入れないこと
・SSDに衝撃を加えないこと
・SSDは数時間以上冷却してから使用すること。液体窒素の補給を忘れ、
remote shutdown で高圧が遮断された場合は速やかに電源を落として、昇
温すること。この時液体窒素を補給してはならない。
・高圧を印加するとき、落とすときは準静的に行なうこと
・12 時間毎に液体窒素を補給し、補給記録を残すこと



ケーブルは REMOTE SHUTDOWN、 アンプ電源、 SIGNAL、 高圧電源の順に接続し、 逆の順に外すこと。ステーションに依ってモジュールの型番が異なることがある。また、印加電 圧は SSD に記された電圧を印加すること。
SCA についての注

・LOWER LEVEL は 0.02 - 10.02V

INTEGRAL/NORMAL/WINDOW
 INTEGRAL: LL と UL は独立に設定出来るが SCA 出力に対して UL は無視される
 NORMAL : LL と UL は独立に設定出来、この間の信号が SCA 出力となる
 WINDOW : LL はベースラインレベル(0 - 10V)を UL はウィンドウ幅(0 - 1V)を設定出来、この間の信号が SCA 出力となる

アンプについての注

・最大計数率は時定数によって変化するが数千 cps 以上では数え落しの補正をきちんとするべき である。shaping time を大きくするとエネルギー分解能は向上するが、最大計数率は落ちる。 検出器、回路が受ける信号は散乱や妨害蛍光 X 線を含めた全ての信号であり、目的の蛍光信号 だけでは無いことに注意すること。

10.6 測定例

測定例としては適当でないかも知れないが、余り良くない例をあげてみる。図に示すのは 0.2mmol/Iの硫酸銅水溶液の蛍光 XAFS である。検出器としては 10.3 節で説明した fluorescent ion chamber detector で、フィルター、ソーラースリットを使い、BL-7C で測定した[10]。入射X線 は sagittal 集光し、データは1点当り 10 秒蓄積した。吸収端は観測されるが、明らかに散乱X 線による信号が支配的である。

この測定では比較試料として同じ条件で水の蛍光 XAFS を測定し、散乱、フィルターからの 蛍光信号を取り除いた(スペクトルは文献 10 参照)。この様に特に希薄な系でのデータ処理、 解析には注意を要する。



図 10.6.1 0.2mmol/l 硫酸銅 水溶液の蛍光 X A F S の生 データ(文献 1 0 より)

第11節 周辺設備

XAFS 等の実験支援の為にいくつかの道具があるのでそれらの取扱いを示す。なお、設置場所 等は執筆時点のもので、予告無く変更することがある。

11.1 電力、冷却水、圧搾空気、排気

各実験ステーションには三相交流 200V、単相交流 100/200V が供給されている。電力容量を 表 11.1.1 に記す。通常単相 100V については 10A 程度を測定機器で、三相 200V については 10A 程度をビームライン排気に使用しているので、残りがユーザー持込み機器で使える容量となる。 BL-9A、10B、12C では現在使用している電流量が電流計に表示される(三線式配線の場合はスイ ッチで各線を切り替えて読む)。ロータリーポンプは単相 100V では約 10A を必要とするのでポ ンプ類は出来るだけ三相交流を用いること。またドライヤーも 10A 程度使用するので充分に注 意すること。ブレーカーを落とすと、最初からやり直しになる。

持込み機器を接続する前に**絶縁試験**をし漏電発生の可能性をなくしておくと共に必要な電力を 明らかにしておくこと。接続後はクランプメーターで漏電を点検すること。各ステーションには **漏電検出器**があり、30mA 以上の漏洩電流を検出するとブザーが鳴る。起動時のみの漏洩電流を 検出した場合はリセットを押せばブザーは停止するが、停止しない場合は新たに接続した機器を 外し、漏電の原因を取り除いた上で接続すること。ユーザーは「ブザー停止」を押してはなら ない。

BL-7C、9A、10B、12C の機器の内、瞬間停電・電圧低下等のためにリセットされると被害 の大きいいくつかの機器は UPS でバックアップしている。ただし数分程度以上の能力を持たな いので、停電した場合は直ちに停止措置をとること。

	BL-7C	BL-9A	BL-10B	BL-12C
単相100Ⅴ	20A	-	20A	20A
単相 100/200V	30A	50A	20A	20A
三相200∨	50A	30A	50A	50A

表 11.1.1 電力容量

BL-9A ではビームライン用、ユーザー実験用の電力が分離されており、ユーザー実験用分を記した。

	BL-7C	BL-9A	BL-10B	BL-12C
制御用 PC				
制御用 PC の CRT				
ロータリーエンコーダーのカウンタ			なし	
-				
パルスモーターコントローラー	1	1		1
端末用 PC				
端末用 PC の CRT				
端末用 PC の MO	なし			

表 11.1.2 UPS 等でバックアップされている機器のリスト

UPS でバックアップしている機器

1 PM4C-05、PM16C-02、PM16C-02Nの内部データはバックアップされている。

冷却水は閉鎖循環系の純水を使用している。クイックジョイントで接続され、入口圧力は約 5kg/cm²、出口圧力は約 4kg/cm²である。冷却水接続用にはステンレス製のものを用い、真鍮等 の純水を著しく汚染する材質を使用してはならない。また一般市水より圧力が高いので配管材料、 接続には注意を要する。循環水を汲み出してはならない。循環水を利用できない場合は後述する チラーを利用する(11.16 節)。

主にバルブ等の駆動のために**圧搾空気**が供給されている(6kg/cm²)。

ステーションで有害ガス、可燃ガス等を用いる場合は閉鎖系で使い、回収ガスを除害の上、可 燃、有害ガス排気ダクトに流す。また漏洩を測定する。この場合、事前にガス関係の安全責任者 と打ち合わせ、所定の手続きをとっておくこと。それ以外のロータリーポンプの排ガスはポリ製 の排気ダクトに接続する。

11.2 クライオクーラー及び温度制御器

11.2.1 クライオクーラー

BL-9A、10B、12C には試料冷却用のクライオクーラー、温度コントローラー、クライオクー ラー位置調整機構、真空排気系が設置されている。これらを使用する場合は実験計画書に明示す ること。これらは基本的に同じ仕様のクライオクーラーを使用している。BL-9A と 12C はクラ

BL-10B で使用	しているクライオクー	-ラー				
クライオクーラ	クライオクーラー : Cryosystem 社製 LST-21					
	closed cycle	refregerator system				
冷却能力:	second stage	second stage				
	の負荷 / W	の温度 / K				
	0	12.0				
	1.0	18.5				
	1.5	22.0				
但しこのデータ	は 60Hz で動作させた	こ時の値である。				
無負荷時に 20K	に達するまでの時間	: 30min (実際にはもう少しかかる)				
一定自荷での温	度の安定性	: +1.5K				
BL-9A、12C で	使用しているクライス	オクーラー				
クライオクーラ	- : CTI Model 2	22C CRYODYNE cryocooler				
	closed cycle	refregerator system				
	5	0 7				
冷却能力:	second stage	second stage				
	。 の負荷 / W	の温度 / K				
	0	10.0				
	1.0	16.0				
	1.5	19.0				
但しこのデータは 60Hz で動作させた時の値である。						
無負荷時に 20K に達するまでの時間: 30min (実際にはもう少しかかる)						

イオクーラーを縦置きにしており、試料取り付け部の寸法も同一である。BL-10B では横置きと なっている。

コンプレッサーは BL-9A では制御ラック背部、BL-10B ではモノクロメーターと実験ハッ チの間、BL-12C では実験ハッチ屋上に設置してある。BL-12C の場合はコンプレッサーにアク セスし難いので、コンプレッサーの電源スイッチを実験ハッチ壁に取り付けてある。BL-9A、10B では COMPRESSOR、COLDHEAD の二つのスイッチを ON にする。通常、後述する温度制御 器と組み合わせて使用する。

11.2.2 温度制御器

[BL-10B]

BL-10B では Lake Shore Cryotronics 社製の Model DRC-80C Digital Cryogenic Thermometer/ Controller を使用している。主な仕様を次ページに記す。



図 11.2.1 DRC-80C のパネル図

- 1: 電源スイッチ
- 2: 温度設定用サムホイールスイ ッチ
- 3: Gain 設定(P動作設定)
- 4: Reset 設定 (積分器のリセット 時定数設定)
- 5: 温度表示器
- 6: スケール拡大 (30K 以下で 0.01K, 100K 以下で 0.05K 表 示)
- 7: 温度表示するセンサー設定
- 8:温度制御するセンサー設定
- 9: ヒーター出力設定
- 10: 電源ケーブル
- 11: フューズ
- 12: センサー A の入力(標準)
- 13: センサー B の入力
- 14: 記録用アナログ温度出力
- 15: ヒーター出力
- 16: ヒーター用フューズ
- 17: なし
- 18: GND

操作手順:

- 1. 試料を取り付け 1×10⁻² Torr まで排気し、バルブを閉じる。遅くとも 100K に到達する前 にバルブを閉める。開けたまま放置するとコールドヘッドがロータリーポンプのオイルトラ ップになってしまう。また充分に排気してから冷却を開始した方が結果的には早く冷える。
- 2.モノクロメーターとハッチの間にあるコンプレッサーの電源SWを ON にする。
- 3.温度制御器の電源を入れ、KELVIN と書かれたサムホイールスイッチを希望の温度に設定 する。この時センサーはAを、ヒーターは HI を、スケール拡大は NORM を選択する。
- 4.希望の温度で安定する様にGAINとRESETを調節する(下記)。
- 5.温度が安定したら測定する。
- 6.測定が終ったらコンプレッサーの電源 S Wを OFF にする。
- 7.温度制御器の KELVIN と書かれたサムホイールスイッチを 300K に設定する。

Lake Shore Cryotronics 社製 Model DRC-80C
Digital Cryogenic Thermometer/Controller
測温精度:±0.5K at 0.5K and 77K, ±1.0K at 273K.
ヒーター出力:Hi:0-25W(1A max. 25V max.), Lo:0-10W(1A max. or 12V max.)
温度のアナログ出力基板付き(DRC-8L/A) 10mV/Kの出力
センサーは Lake Shore Cryotronics 社製 DT-500CU-DRC-36(シリコンダイオード)が second stage に付いている。
オプションで DT-500-DRC 等のセンサーを取り付けることも可能。

- 8. ヒーターを HI にする。(330K 以上に上げないこと。330K 以上に昇温するとセンサーの特 性が変化する。)
- 9. 温度が上昇するのを待つ。温度表示が 300K になってもすぐには leak せずに数分待ち、更 に設定温度を 200K 位に下げて 2~3 分待つ。表示温度が室温より下がってくる場合は温度 が充分に上がっていないので再度 300K に設定し直して暫く待つ。急ぐときは乾燥窒素でパ ージしても良いが、Kapton 窓を破らない様、圧力に注意すること。パージガスとしてヘリ ウムを用いてはならない。
- 10.温度制御器の電源を切る(電源を入れっぱなしにしておくとヒーターに通電されて、ヒー ター断線の原因となる)。
- 11.リークして試料をはずす。

<u>温度制御器の動作説明</u>

[測温]10µA の定電流源から電流がダイオードに供給され、ダイオード両端に発生した電圧を 読みとる。この電圧は ADC でディジタイズされ、マイコンはこの電圧を標準電圧・温度データ と比較して温度を表示する。

[制御]サムホイールSWの設定を読み込み、対応する電圧を演算する。出力は DAC でアナロ グ化される。ダイオードからの信号とこの基準信号は誤差増幅器に入り、PI制御される。P動 作は GAIN で、I動作は RESET で制御される。

Gain と Reset の調整

Gain は CCW 一杯で×1、CW 一杯で×100 であり対数で変化する。先ず Gain、Reset の両 方とも左一杯に回しておき、設定温度を表示温度より数度上に設定する。Gain のつまみをゆっ くりと右に回すと次第に設定温度と表示温度の差が小さくなる。ある程度右に回すと温度に振動 が生じるのでそうならない内に止める。Reset を回すと設定温度と表示温度の差が無くなる。 右回しで時定数が小さくなる。

冷凍機は常に能力一杯で冷却し、温度制御器がヒーターを制御することで温度制御している。 冷凍機の冷凍能力は温度の関数であり、試料や外部環境によって熱負荷、熱流入も変化するので こまめに調整する必要がある。背面のヒーター出力電圧と温度をレコーダーに記録しながら調整 をするとやり易い。この時、**ヒーター及びレコーダ出力端子を短絡しないよう注意すること**。

11.2.3 温度制御器

[BL-9A、12C]

BL-9A、12C では Scientific Instruments 社製の Model 9650 Microprocessor-based digital temperature indicators/controllers を使用している。主な仕様は以下の通り。

操作手順は BL-10B のものと基本的に同じである。 MAN モードを選択し、通常は温度と PID のパラメータを設定するのみである。

> Scientific Instruments 社製の Model 9650 Microprocessor-based digital temperature indicators/controllers 測温精度:±0.1K (35K 以下)、±0.5K (35K 以上). ヒーター出力:60W max. (ヒータ側の制約から 30W に設定してある) 温度のアナログ出力付き 0.02V/K の出力 センサーは Si-410 (シリコンダイオード)が second stage に付いている。



図 10.2.2 SI9650 の正面パネル 中央下部のキーパッド STOP: 温度計測のみ MAN:通常の温度制御 RUN:設定に基づいた自動温 度制御 右のキーパッドで設定し、中央上 部の液晶に表示される。

温度設定

- 1. <SET>キーを押して temperture/setpoint 値を表示。
- 2. <edit>キーを押して setpoint field にカーソルを移す。
- 3. 数値キーを用いて設定温度を入力する。
- 4. <enter>キーを押して、この設定を有効にする。

PID 設定

- 1. <PID>キーを押して、PID パラメータを表示する。変更前にこの値を log book に記録する。
- 2. <edit>キーを押して Proportional term field にカーソルを移す。
- 3. 数値キーを用いて設定値を入力する。
- 4. <edit>キーを押すと、次のフィールド(P I D)へカーソルが移動する。
- 5. 3、4の操作を繰り返す。

6. <enter>キーを押して、この設定を有効にする。

詳細についてはステーション備え付けの SI 9650 の取説を参照のこと。PID 値の選び方もその 中に記述してある。

11.2.4 真空漏れ探し等

クライオクーラーの真空槽の真空度が1×10⁻² Torr まで下がらない時はリークテストを行い、 真空が良くならない原因を解明し、対策を打たなければならない。圧力が下がらない原因として は、 真空槽内部での脱ガス、 真空漏れが考えられる。脱ガスは良く昇温せずにリークして結 露した場合、蒸気圧の高い試料を使用した場合等が考えられる。真空槽内部を清浄にし、必要が あればドライヤー等で軽く昇温する。 真空漏れがある場合は、漏れている場所を特定し、漏れを止める必要がある。漏れを止めずに 排気したまま冷却すると、ローターリーポンプの油が真空槽内部にトラップされ、漏れた空気中 の水分が結露し、益々状況を悪くする。クライオクーラーには熱電対真空計が付いているので、 漏れの可能性のある場所にアルコールを極少量を吹き付け、メーターの指示値の変化を観察する。 一般的に漏れる可能性がある場所は、 直前に作業をした箇所、 普段取り外しをする真空槽の O リング当たり部、 Kapton 窓付近である。 については実験をしているグループまたはその 前に実験をしたグループが正確に記録をとることによって分かる。 で、筒側の O リング当た り面や O リング溝に傷が付いている場合はスチールウール等で当たり面を滑らかにする、O リ ングに塵が付いている場合はアルコールで清掃する。O リングには薄く(目視では分からない 程度)グリースを塗布する。 では 同様に O リング当たり面、溝の傷、Kapton 窓自体の傷、 Kapton 接着の剥がれ等が想定される。窓自体の損傷の場合は担当者に連絡して交換する。

11.3 XAFS測定用反応試料槽

この試料槽は触媒反応の in-situ 実験を目的として東京大学理学部化学教室黒田研(当時)に よって製作された。BL-10B の戸棚に置いてある。使用を希望する場合は実験計画書に明示する こと。

試料槽全体はステンレス(SUS304)製の真空チェンバーからなる。上下面のフランジ径がICF ∲152、フランジ底面からデュワー上部迄の高さが 400mm である。試料はボロンナイトライド (BN)製セルに詰め、反応炉の内部に装着する。上面フランジを閉じることにより、カプトン 窓から入った 線が試料を透過し、反対側のカプトン窓から抜ける配置が得られる。従って、透 過法配置専用である。

特徴として

- 1. XAFS 測定装置に容易に設置できる形、大きさである。
- 2. 試料を不活性雰囲気下あるいは真空中に保持できる。
- 3. 反応気体 (H₂、O₂、CO etc.)を導入できる。
- 4. 加熱反応のために、約600 迄の加熱制御ができる。
- 5. EXAFS 測定時の熱振動効果の抑制、または反応抑制のため冷却が可能。
- 6. 測定に必要な試料が微量で済む。
- 7. 試料槽自身による 線の吸収が少ない。

詳細は BL-10B ステーションに備え付けのマニュアルに譲る。使用希望者は北海道大学触媒 科学センターの朝倉教授とコンタクトをとる事が望ましい。現在は実験ステーションで H₂や CO 等のガスを流しながら利用する場合は除害の後、有害ガス排気ダクトに流す必要がある。化学試 料準備室で処理をし、現場へ持ち込むケースが多い。

この試料槽について publish されたものは入手していないが同主旨のものの文献[20, 21]が参考となるであろう。

11.4 電気炉

この電気炉は岡山大学理学部の前田、圓山らのグループが設計したものである。BL-10B 背面 側の移動式棚の中に置いてある。使用を希望する場合は実験計画書に明示すること。

この電気炉は、透過法 XAFS 専用電気炉である。熱源はニクロム線の Inner Heater と Outer Heater であり、室温から約 500 までの範囲を Inner Heater のみで、約 500 から約 1000 までの範囲を Outer Heater で粗調し、Inner Heater で微調することにより温度制御している。

温度モニター用の熱電対は、クロメルーアルメル熱電対(シース型熱電対、商品名サーモコア ックス:フイリップス社)を用いており、Inner Heater 下部と Sample Holder のところに取り 付けられている。電気炉内には熱遅れがあるため、Inner Heater 部にある熱電対からの出力を 受けて、大型温調機から Inner Heater に電圧を印加して温度調節をする。Sample Holder のと ころにある熱電対からの出力は、Sample の温度として小型温調器によりモニターされる。

また、試料の雰囲気としては真空(10⁻⁶Torr)及びガス中(Ar、He、N₂等)が可能である。 ガス雰囲気下で用いる時はガスの熱膨張を考慮する事。

詳しくはステーションに備え付けのマニュアルを参照すること。

11.5 赤外線ゴールドイメージ炉

真空中での XAFS 測定(透過法、蛍光法)において試料の温度調節を高速かつ高精度に実現 することを目的として製作された。BL-10B の戸棚に置いてある。使用を希望する場合は実験計 画書に明示すること。

(特徴)

- ・ 高速加熱・冷却が可能
- ・ 到達温度が高い(1000)
- ・ 温度分布が均一
- 高精度の温度調節が可能
- ・ 高温、高真空・ガス雰囲気中での測定が可能

11.6 試料位置調整機構

微小試料の位置合わせを目的とした位置調整装置である。 元々はダイヤモンドアンビルを使用した高圧実験でアライン メント、ダイヤモンドからの回折を除くために製作したもの である[22]。Huber 社製 1003 ゴニオメーターヘッドに取り 付けた微小試料をハッチの外から遠隔操作し、 線を当てな がら位置調整できる(図 11.6.1)。X、Y、Z の移動及び X、 Y 軸周りの傾きの合計 5 つの自由度がありそれぞれ DC モー ターにより外部より操作することができる。上部に回転ステ ージを立てることにより、偏光依存性実験等にも利用出来る。

BL-10B 及び 12C の戸棚に通常置いてある。使用を希望 する場合は実験計画書に明示すること。サンプルホルダーの 寸法等、詳しくは担当者まで。



Large Goniometer Head 1003, 1003a, 107 mm,

Reading accuracy 0,1°; 2 spec. holder; 1 adjustment point; 1 spanner; adhesive wax; 1 storage container. Weight 1000 g.

図 11.6.1 Huber 1003 ゴニオヘッ

ド

11.7 全反射実験用試料方位調整機構 [BL-12C]

大気下での全反射蛍光 XAFS 実験時に試料の位置、照射角等を調整するために、名古屋大学 工学部竹田研究室で設計された。中央精機製 MM-40GU(照射角調整用スイベルステージ) MM-40XY(X,Y ステージ)、MM-60V(Z ステージ)から構成されており、オプティカルベンチ上 に設置して使用する。各軸は同社製 MMC-2 パルスモーターコントローラでハッチ外から制御で きる。現状では BL-12C でのみ使用可能である。使用を希望する場合は実験計画書に明示する こと。

11.8 錠剤成形器

[BL-10B]

ペレット状の試料を調製するため KBr 錠剤成形器、ハンドプレスが用意してある。

ハンドプレス:島津製作所製 SSP-10

最大加圧能力 10 トン

KBr 錠剤成形器:島津製作所(202-32010)

錠剤直径 ϕ 13

加圧荷重 8トン

- ・詳細はステーション備え付けのマニュアル参照のこと。
- ・他の錠剤成形機の部品と混ぜないこと。
- ・薬品、乳バチ類は各自用意すること。

BL-10Bの背面側に通常置いてある。

11.9 ポリシーラー

ポリエチレンシート等の融着のために用意してある。BL-10B及び12Cの戸棚に置いてある。



加熱調整表

	ポリエチレン	ポリプロピレン 其の他高温フイルム
1	0.06%11 F	
2	0.1 ~	
3	0.14 "	
4	0.2 ~	0.03%北下
5		0.044 ~
6		0.06
7		0.08 "

 ・厚さを表す%は2枚以上の合計です
 ・上記は基準です。材質、電圧により 変わります。適宜加減して下さい。

使用法

袋の材質、厚さにより上の表を基準にして前面の加熱時間調整ツマミを調整する。

左手で袋を持ち、袋の口をシール台上に置き右手で上部レバーを押しさげる。(電子式タ イマーのため早く押さえる必要はない。)

前面赤色パイロットランプが点滅し、そして消える。

レバーを押さえたままパイロットランプが消えてから 1~2 秒待ちレバーを上げるとシー ルできる。

11.10 真空ポンプ

11.10.1アルカテル社製 T2012A

BL-9A、10B、12Cのクライオクーラーの排気用に用いるが、他に流用も可。 排気速度 : 260 ℓ/min 到達真空度 : 7.5×10⁻⁴ Torr 2.0×10⁻² Torr (ガスバラスト弁使用時) 電源 : 三相 200V 引き口寸法 : NW25

通常の始動及び停止

電源スイッチを押すことで始動する。ポンプ停止はモーターのスイッチボックスの OFF ボタ ンを押す。逆流防止弁は付いているが、**停止後は真空槽側をリークする**こと。

フォアライントラップ内のアルミナが湿気を吸っていると、圧力が下がるまでに時間が掛かる。

11.10.2 真空機工製 G-20D

BL-9A 及び 10B に置いてある。錠剤成型器や少量の試料槽の排気等に利用出来る。

排気速度 : 20 ℓ/min

到達真空度 : 1×10⁻³ Torr 電源 : 単相 100V 引き口寸法 : 外形∳18mm の管

11.11 ペンレコーダー

BL-7C、9A、10B

横川北辰電機(YEW)製バーチカルペンレコーダー 3056-33

最高感度	•	50 µ V/cm
以回心及	•	$JU\mu V/UII$

: 3

- 測定範囲 : 50 µ V/cm ~ 5V/cm の 16 種切り換え
- チャート送り速度 : 2,6,20,60 cm/min 及び cm/h の 8 種

機能も絞られており、操作も特に説明を必要としないでしょう。

BL-12C

横川電機(YEW)製ペン	ソレ	$\gamma \exists - \vartheta - LR4110$
ペン数	:	3
最高感度	:	100μV/フルレンジ
測定範囲	:	100 μ V/フルレンジ~200V/フルレンジの 20 種切り換え
チャート送り速度	:	10mm/h~1200mm/min の 34 種。チャート送り速度を 1mm 単位で設
定も可能。		
最近の標準的なレコ	- I	ダですので、特に説明はいらないでしょう。

11.12 ディジタルマルチメーター

Ľ	BL-7C] ア	ドハ	(ンテスト	• TR6848	4-1/2 桁
	直流電圧	:	30mV ~	1000V	6 レンジ
	交流電圧	:	300mV	~ 750V	5 レンジ
	抵抗	:	30 ~	300M	8 レンジ
	直流電流	:	300 µ A	~ 10A	6 レンジ
	交流電流	:	300 µ A	~ 10A	6 レンジ

[BL-9A] 🤇	ヮドノ	バンテスト R6551	5-1/2 桁
直流電圧	:	300mV ~ 1000V	5 レンジ
交流電圧	:	300mV ~ 700V	5 レンジ
抵抗	:	300 ~ 300M	7 レンジ
直流電流	:	300mA ~ 3A	2 レンジ
交流電流	:	300mA ~ 3A	2 レンジ
[BL-10B]	タケ	ダ理研 TR6844	4-1/2 桁
直流電圧	:	20mV ~ 1000V	6 レンジ
交流電圧	:	200mV ~ 750V	5 レンジ
抵抗	:	20 ~ 20M	7 レンジ
直流電流	:	2μA ~ 200mA	6 レンジ
交流電流	:	$200 \ \mu A \ \sim 200 mA$	4 レンジ
タケダ理研	TF	86848 4-1/2 桁	
直流電圧	:	30mV ~ 1000V	6 レンジ
交流電圧	:	300mV ~ 750V	5 レンジ
抵抗	:	30 ~ 300M	6 レンジ
直流電流	:	$300 \mu A \sim 10 A$	6 レンジ
交流電流	3	00 μA ~ 10A 4	レンジ
[BL-12C] 夕	ケダ	`理研 R6441B	4-1/2 桁

$[\mathbf{DL}^{-1}\mathcal{L}\mathbf{C}]$))	11111 1111111111111111111111111111111	4-1	/~ 11J
直流電圧	:	20mV ~ 1000V	6	レンジ
交流電圧	:	200mV ~ 700V	5	レンジ
抵抗	:	200 ~ 200M	7	レンジ
直流電流	:	200mA ~ 10A	2	レンジ
交流電流	:	20mA ~ 10A	4	レンジ
周波数	:	20Hz ~ 200kHz	5	レンジ

11.13 ポラロイドフィルム現像機

ポラロイド4×5ランドフィルムホルダー #545。各ステーションの工具箱上にある。 現像の手順は

- 1. レバーをL側にする。
- 2. フィルムの THIS SIDE TOWARD LENS が開口部から見え、かつ金具が先に入る方向で突き 当たるまで挿入する。
- 3. レバーをP側にし、フィルムを引き出す。
- 4.15 秒ほど放置し、遮光シートを剥す。

11.14 小型ミラー

第5節で記したように、低エネルギー域での測定にとってミラーは必需品である。ビームラインにミラーが設置されていないラインでもハッチ内にセットをして利用出来る小型のミラーが用

意してある。ミラーとしては熔融石英製のものと、それに白金蒸着したものの二枚がある。ミラ ーホルダーには上下動(Z)と照射角()の二つの自由度があり、ハッチ外から制御できる。 ミラーの寸法は 60(W) × 250(L) × 7.2(t)である。BL-7C 用の戸棚に収納してある。

ミラーはハッチ内の入射スリット直前に設置し、調整後はミラーケース内にヘリウムガスを流 しX線の吸収を防ぐ。幾何光学で理解できるので、調整方法は 5.5.4 節を参考にして考えて頂き たい。使用を希望する場合は実験計画書に明示すること。

11.15 マルチチャネルアナライザー

Canberra 社製 35PLUS マルチチャンネルアナライザ(MCA) 2 台及び EG&G Ortec 社製 7450 1 台が使用出来る。35PLUS は 100MHz の Wilkinson 方式 ADC を備えたものと 200MHz の Wilkinson 方式 ADC を備えたものがあり、各々 BL-12C、7C に常備している。7450 は 100MHz の Wilkinson 方式 ADC を備えてあり、BL-9A に置いてある。

また、BL-12C の端末用 PC にはラボラトリイクイップメント社製のボード型 MCA/PC98A(Wilkinson 方式 200MHz)が内蔵されている。

SSD を用いて蛍光 XAFS の波高分布を測定する場合、SCA のウィンドウを設定する時等に用 いる。MCA を使用するのは放射線計測に習熟した人であろうし、説明を記すと長くなるので文 献を参照されたい[23, 24]。使用を希望する場合は実験計画書に明示すること。

11.16 チラー

電気炉の冷却用等で循環水を使用出来ない場合に使用する(東京理化 cool ace CA-111)。BL-10B ハッチの裏側に置いてある。使用を希望する場合は実験計画書に明示すること。

第12節 トラブルシューティング

本節では初心者が陥り易いトラブルへの対処法をまとめた。電源が入っていない、スイッチが 切ってある等の極く初歩的なトラブルは除外した。ほとんどの事は本書で説明してあるので、説 明してある箇所を引用することで、解決法とした。障害が発生した場合は、正確な記録(症状、 原因、対策)を log book に残すこと。

12.1 パソコン関係

症 状	原因	対策
パソコンは起動するが N88- BASICが立ち上がる	システムが HD を認識出来ず ROM BASIC が立ち上がった	FD を除き RESET ボタンを押 す
起動時に COMMAND.COM が 見つかりませんというエラーメ ッセージが出る	データ用の FD を挿入した状態 でパソコンを起動した	FD を除き RESET ボタンを押 す
スペクトル測定中にメッセージ なしに停止する	スケーラまたは PC との通信障 害	スケーラの状態を確認し、全て の表示・設定の状況を log book に記録する。設定時間を超えて も計数中であればスケーラの STOPを押す。設定時間前に止 まっている場合は設定時間の M,N を正しく設定し(t=M × 10 ^{N-1} 秒)、COUNTを押す。復 旧しない場合は担当者を呼ぶ。 冬期に静電気で発生するケース が多い。この場合は特定の人間 で多発するので、操作する人間 を替える。
		18日 0 ない場合は NIM-BIN 内 の高圧電源の電圧を落とし、 BIN の電源、PC の電源を落と して、再投入する
スペクトル測定終了後、 Printing to LBPのメッセージ を CRT に表示し、PC の処理 が止まった様に見える	プリンタの障害	プリンタの状態(紙切れ、紙詰 まり等)を確認し、対処してオ ンラインのランプが点いた状態 にする。
FD にセーブしたデータが読め ない	FD ドライブの設定誤り (7C,12C)	原因に依り、復旧できる場合と 出来ない場合がある。その FD には書き込まず、野村まで連 絡。詳細は PFXAFS の web site 参照。

FD にセーブしたデータが読め ない	FD ドライブの障害 FD メディアの障害	ディスク修復ツールを使って修 復する。相談にはのりますが、 専門家(業者)の力が必要な場 合もある。
		被害の拡大を防ぐため、必ず担 当者に連絡してください。
MO メディアを取り出せない	MO ドライブの障害	MO ドライブの電源を落とし、 イジェクトツールで取り出す。
プリンタへの印字にむらがあ る。または印字が薄い。	トナー不足	トナーカートリッジを振ってみ る。それでも駄目なら担当者を 呼ぶ。
プリンタ用紙が無くなった		プリンタ下部または周辺に紙の ストックがあるので補充する。

12.2 スペクトル関係

症 状	原因	対策		
エネルギーが狂う。tune が狂 う	モノクロメーターのバックラッ シュ	必ず高角 低角方向に送る		
信号が出ない	電離箱の再結合防止用電場不足	7.2 参照		
	信号線断線	修理する		
	BNC コネクタの接触不良	コネクタ外周を磨く		
信号が異常に小さい	モノクロの tune の調整不良	第4節参照		
	スリット、ステージの位置不良	第6節、7.4.1参照		
	電流増幅器の利得不足	7.4.4 参照		
	電離箱用ガスの選択不良	7.4.2 及び第二部第 6 節参照		
	電離箱の再結合防止用電場不足 または印加されてない	7.2.2 参照		
preedge 域が noisy	電離箱の再結合防止用電場不足	7.2.2 参照		
	電流増幅器の飽和	7.4.4 参照		
preedge が上に凸	高次光が無視できない	第2部第2節参照		
postedge が noisy	高次光が無視できない	第2部第2節参照		
スペクトル全体が noisy	高次光が無視できない	第2部第2節参照		
	試料が均一でない	第2部第2.3節参照		
	試料の設定位置の不良	第2部第2.3節参照		
	信号ケーブル不良	コネクタの取付を修理する		
	電離箱の再結合防止用電場不足	7.2.2 参照		

スペクトル全体が noisy	ガスの漏れ	Swagelock の締め付け、リー ク場所を探して、封止する。
プロック毎にスペクトルの傾き が変化する、叉は不連続になる	ガスの交換不足	7.4.2 参照
focus 時に分解能が悪い(7C) 分解能が悪い(12C)	面内回転調整不良 ミラー前スリットの開口が大き	4.6 参照 6.3 参照
	61	

12.3 周辺機器関係

症 状	原因	対策
クライオの温度が下がらない	真空引き不足	11.2.2 節参照
	真空槽内部の汚染	内部をアルコールで清掃する。
	真空漏れ	11.2.5 節参照
	真空槽と低温部の接触	昇温し、組立て直す
	配線と真空槽の接触	
クライオを昇温出来ない	温度制御器の不良、ヒーター断	担当者に連絡
	線	
クライオの測温出来ない	ダイオードへの配線断線	断線箇所を修理
クライオの温度が安定しない	PD(10B)、PID の設定不良	10.2 参照

第13節 参考文献

- [1] 放射光共同利用実験応募資料 高エネルギー加速器研究機構 管理局 国際研究協力部 研究 協力課 共同利用第二係で入手出来る。またほぼ同じ内容を PF のホームページ (http://pfwww.kek.jp/indexj.html)で閲覧出来る。
- [2] 「安全ハンドブック」、「放射光利用実験を安全に行うために」、「放射線安全の手引き」、「化 学薬品等取扱の手引」、「電気安全の手引き」等の資料が用意されている。上記共同利用第二 係または放射光事務室で入手出来る。一部は機構の web サイトから閲覧出来る。
- [3] T. Matsushita and H. Hashizume, "X-ray monochromators" in "Handbook on synchrotron radiation vol. 1" ed. by E. E. Koch, North-Holland Publ., Co. 1983.
- [4] S.M.Heald, *Nucl. Instrum. Methods*, A266, 457 (1988). R. W. Alkire, M. Sagurton, F. D. Michaud, W. J. Trela, R. J. Bartlett and R. Rothe, *Nucl. Instrum. Methods*, A352, 535 (1995).
- [5] T.Matsushita and R.P.Phizackerley, Jpn. J. Appl. Phys., 20, 2223 (1981).
- [6] J. Cerino, J. Stöhr, N. Hower and R. Z. Bachrach, *Nucl. Instrum. Methods*, **172**, 227 (1980), T. Ohta P. M. Stefan, M. Nomura and H. Sekiyama, *ibid.*, **A246**, 373 (1986), A. A. MacDowell, D. Norman and J. B. West, *Rev. Sci. Instrum.*, **57**, 2667 (1986).
- [7] J. A. Golovchenko, R. A. Levesque and P. L. Cowan, Rev. Sci. Instrum., 52, 509 (1981).
- [8] M. Lemonnier, O. Collet, C. Depautex, J. M. Esteva and D. Raoux, *Nucl. Instrum. Methods*, 152, 109 (1978), J. Goulon, M. Lemonnier, R. Cortes, A. Petournard and D. Raoux, *ibid.*, 208, 625 (1983).
- [9] T. Matsushita, T. Ishikawa and H. Oyanagi, Nucl. Instrum. Methods, A246, 377 (1986).
- [10] M. Nomura, A. Koyama and M. Sakurai, *KEK Report* 91-1 (1991).
- [11] C. J. Sparks, Jr., B. S. Borie and J. B. Hastings, Nucl. Instrum. Methods, 172, 237 (1980).
- [12] A. Koyama, M. Nomura, H. Kawata, T. Iwazumi, M. Sato and T. Matsushita, *Rev. Sci. Instrum.*, 63, 916 (1992).
- [13] M. Nomura and A. Koyama, KEK Report 95-15 (1996).
- [14] J. Jaklevic, J. A. Kirby, M. P. Klein, A. S. Robertson, G. S. Brown and P. Eisenberger, Solid State Comm., 23, 679 (1977).
- [15] P. A. Lee, P. H. Citrin, P. Eisenberger and B. M. Kincaid, Rev. Mod. Phys., 53, 769 (1981).
- [16] J. Wong, Nucl. Instrum. Methods, 224, 303 (1984).
- [17] F. W. Lytle, R. B. Greegor, D. R. Sandstrom, E. C. Marques, J. Wong, C. L. Spiro, G. P. Huffman and F. E. Huggins, *Nucl. Instrum Methods*, **226**, 542 (1984).
- [18] S. P. Cramer and R. A. Scott, *Rev. Sci. instrum.*, 52, 395 (1981), S. S. Hasnain, P. D. Quinn, G. P. Diakun, E. M. Wardell and C. D. Garner, *J. Phys.*, E17, 40 (1984), H. Oyanagi, T. Matsushita, H. Tanoue, T. Ishiguro and K. Kohra, *Jpn. J. Appl. Phys.*, 24, 610 (1985).
- [19] F. S. Goulding, J. M. Jaklevic and A. C. Thompson, SSRL Report, 78/04 (1978). S. P. Cramer, O. Tench, M. Yocum and G. N. George, Nucl. Instrum. Methods, A266, 586 (1988). C. Morrell, R. L. Bilsborrow and G. E. Derbyshire, Daresbury laboratory, DL/SCI/TM63E (1989).
- [20] F. W. Lytle, P. S. P. Wei, R. B. Greegor and G. H. Sinfelt, J. Chem. Phys., 70, 4849 (1979).
- [21] K. Asakura and Y. Iwasawa, J. Phys. Chem., 93, 4213 (1989).
- [22] S. Sueno, I. Nakai, M. Imafuku, H. Morikawa, M. Kimata, K. Ohsumi, M. Nomura and O. Shimomura, *Chem. Lett.*, 1663 (1986).
- [23] 岡村廸夫、「放射線測定回路とシステム」、日刊工業社 (1975).
- [24] 岡村廸夫、原子力工業 18 (10) 4 (1972)、岡村廸夫、原子力工業 21 (4) 9 (1975).

第2部

XAFS 実験編

第1節 XAFSに関する主な解説

XAFSに関しては多くの成書、総説が出されているがその中からいくつかをリストアップする。

邦文の出版物

- ・宇田川康夫編著 日本分光学会測定法シリーズ 26 「X線吸収微細構造 XAFS の測定と解析」 (1993) 学会出版センター 実験を中心にまとめてある
- ・石井忠夫著 「EXAFS の基礎 広域 X 線吸収微細構造」(1994) 裳華房 理論を中心にまとめてある。
- ・太田俊明編著 「X線吸収分光法:原理、実験法、解析法及びその応用」(2002?)アイピーシ ー 出版予定

邦文の講習会等のテキスト類

- ・放射光シンポジウム予稿集 「EXAFS でどこまで分かるか」 日本放射光学会 (1990.1.23) 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 2-62-8-507 (有)ワーズ内 tel. 03-5950-4896、FAX 03-5950-1292、email jssrr@kk.iij4u.or.jp
- ・講習会 「EXAFS、XANESの基礎と応用」 日本化学会関東支部 (1986.6.11-12) 〒101 東京都千代田区神田駿河台 1-5 日本化学会関東支部 tel. 03-3292-6163

邦文の解説

- ・大柳宏之、太田俊明 「EXAFS および表面 EXAFS における放射光の利用」、真空、26, 219 (1983).
- ・大柳宏之 「EXAFS 法による局所構造解析法 測定と解析法の可能性と限界 」 分光研究、 34, 271 (1985).
- ・朝倉清高 「広域 X 線吸収構造分光(EXAFS)」、日本化学会編「第4版 実験化学講座 13巻 表面・界面」p.368 (1993) 丸善。
- ·XAFS シリーズ、放射光 11, 314, 388 (1998), 12, 219, 303, 395, 405 (1999), 13, 187, 319, 382, 385 (2000), 14, 55, 143 (2001).

欧文の出版物

- D. C. Koningsberger and R. Prins, "X-ray Absorption: Principles, Applications, Techniques of EXAFS, SEXAFS and XANES", John Wiley & Sons, New York (1988).
- ・B. K. Teo, "EXAFS: Basic Principles and Data Analysis", Springer-Verlag, Berlin (1986) データ解 析法中心
- ・ J. Stohr, "NEXAFS Spectroscopy", Springer-Verlag (1992). XANES 中心
- Y. Iwasawa ed., "X-ray absorption fine structure for catalysts and surfaces", World Scientific (1996).

欧文の総説

 P. A. Lee, P. H. Citrin, P. Eisenberger and B. M.Kincaid, "Extended x-ray absorption fine structure - its strengths and limitations as a structural tool", *Rev. Mod. Phys.*, 53, 769 (1981).
 やや古いが理論、 解析法、実験法等が良くまとめてある • J. J. Rehr and R. C. Albers, "Theoretical approach to XAFS", Rev. Mod. Phys., 72,621(2001).

測定、解析の基準

測定、解析法についてその標準化が測られており、そのワーキンググループのレポートが International XAFS Society の web site (http://ixs.csrri.iit.edu/IXS/)に掲載されている。また、XAFS VI, V のプロシーディングスにも収録されている。和訳は

山口、大柳、桑原、日本結晶学会誌 31, 263 (1989).

XAFS 国際会議のプロシーディングス

これらのプロシーディングスは最新の研究内容をサーベイするにも便利である。

- [XAFS XI] J. Synchrotron Rad., 8, Part 2 (2001).
- [XAFS X] J. Synchrotron Rad., 6, Part 3 (1999).
- [XAFS IX] J. Phys. (Paris) , 7, C2 (1997)
- [XAFS VIII] Physica B, 208 & 209 (1995).
- [XAFS VII] Jpn. J. Appl. Phys., 32, Suppl 32-2 (1993).
- [XAFS VI] "X-ray Absorption Fine Structure" ed. by S.S. Hasnain, Ellis Horwood (1991).
- [XAFS V] *Physica B*, **158**, 701 (1989).
- [XAFS IV] "EXAFS and Near edge Structure", J. Phys. (Paris). 47, C8-Supple 12 (1987).
- [XAFS III] "EXAFS and near edge structure III" ed by K. O. Hodgeson, B. Hedman and J. E. Penner-Hahn, Springer-Verlag (1984).
- [XAFS II] "EXAFS and near edge structure " ed by A. Bianconi, L. Incoccia and S. Stipcich, Springer-Verlag (1983).

第2節 試料調製

2.1 最適な試料の厚さ

2.1.1 透過法の場合

均一な試料を透過法で測定する場合、試料による全吸収 μ_T は目的の原子による吸収 μ_A とそれ 以外の吸収 μ_B に分けて考えられる($\mu_T = \mu_A + \mu_B$)[1]。従って試料に入射する光子数を I_{inc} 、試料 透過後の光子数を I_t とし、厚さ X の試料を考えると

$$I_{\rm t} = I_{\rm inc} \exp(-\mu_{\rm T} X)$$

(2.1.1)

一方、 I_0 用の電離箱で検出された信号 I_d は、入射光子数を I_0 、検出ガスの線吸収係数を μ_x 、光路 長を x_d とすると、

$$I_{\rm d} = I_0 \{ 1 - \exp(-\mu x_{\rm d}) \}, \tag{2}$$

試料に入射する光子数は

 $I_{\rm inc} = I_0 - I_d$

(2.1.2)

(2.1.3)

と表せる。XAFS の全信号は I_d/I_t で表され、XAFS 実験の場合は目的原子による吸収 μ_A 、とりわけその XAFS 振動成分 $\Delta\mu_A$ に関心があるので、XAFS 信号は

$$S = \frac{\partial (I_d / I_t)}{\partial \mu_A} \Delta \mu_A = \Delta \mu_A X \frac{I_d}{I_t}$$
(2.1.4)

ノイズは単純に

$$N = \frac{I_d}{I_t} \left[\left(\frac{\Delta I_d}{I_d} \right)^2 + \left(\frac{\Delta I_t}{I_t} \right)^2 \right]^{1/2} = \frac{I_d}{I_t} \left(\frac{1}{I_d} + \frac{1}{I_t} \right)^{1/2}$$

と表され、S/N 比を求めることが出来る。(μx)_dおよび $\mu_T X$ に関して偏微分し、S/N を最大にする 条件を求めると、(μx)_d=0.245、 $\mu_T X$ = 2.55 で、

$$\frac{S}{N} = 0.556 \frac{\Delta \mu_A}{\mu_T} \sqrt{I_0}$$

となる。このことは I_0 用検出器で 24.5%の光子 を検出し、試料の μ t を 2.55 とした時に最大の S/N 比が得られることを示している。一方上記 の条件から外れると S/N が低下することが予 測される(文献 1、式 2.13)。

例として銀箔を取り上げる。25.5keV 付近で の BL-10B に於ける光子束は 8×10⁷ ph/s で 1 デ ータ点当たり 10 秒積算すると仮定する。I₀ に は Ar を詰めた電離箱を用い、その検出効率は 0.12、I 用電離箱の検出効率は 1 とする。この 場合、k=16Å⁻¹で $k^3\chi=1$ Å⁻³とすると、 $\chi=2.4\times10^{-4}$ と な る 。 こ れ ら の 値 と $\mu_M=51.64$ cm²g⁻¹、



図 2.1.1 銀箔を測定した時の試料の厚さ と *k*=16Å⁻¹における S/N 比の関係。

ρ=10.49gcm⁻³を用いて文献1の式2.13に数値を代入すると、試料の厚さと、*k*=16Å⁻¹ における S/N 比の関係は図 2.1.1 の様になる。絶対値は異なっても同様の関係はある。対応する *k*³χの例を図 2.1.2 に示す。従って可能な限り最適な厚さの試料を調製することが望ましい。この議論は透過 法実験に於ける基本であるが、この条件が重要となるのは入射光子束が限られている場合で、 10¹⁰photons 以上の光子束が入射する場合は**試料の均一性等他の要因が S/N 比を決めるケースが** 少なくない。 試料の厚さを決めるに当たっての幾つかの制約 をまとめると

- 銅の K 吸収端付近ではスペクトル中のµt の 最大値が4以下となるように試料を調製する。 ここで云うµt は I₀、I 電離箱の出力から ln(I₀/I) で求めた見かけのものではなく、真の値であ る(実用的にはブランクとの差と考えて良い)。 より高エネルギー側ではこの制約は緩くなり、 モリブデンの吸収端ではこの制約は殆ど無視 できる。一方、より低エネルギー側ではこの 値より制約がきつくなる。これはX線中に混 じっている高調波によってスペクトルが歪む のを防ぐためである。
- 2. 吸収端の立ち上がりの大きさが余り大きく ならない様にする。これは増幅器、V/F コン バーターを出来るだけ良い条件で用いるため であるとともにいわゆる「thickness effect」(4.6 節)によってスペクトルが歪むのを防ぐためで ある。仮に吸収端の立ち上がりが∆ ut~3 と すると吸収端前後でのX線の強度は 20 倍変 化し、吸収端の前で 2V あった信号は吸収端 直上では 0.1V になってしまう。このためど ちらかで条件の悪いところを使わざるを得な くなる。また単色X線もあるエネルギー的な 広がりを持っているので、吸収端直上ではそ のエネルギーのX線の強度と比べて吸収端直 前のX線の裾の強度が無視出来無くなる。-般には吸収端の立ち上がりは1程度が良い。
- 試料が希薄な場合は吸収端前後よりも、スペクトルの低エネルギー側と高エネルギー側のµtの差が大きくなるので同様の注意を払う必要がある。

-5.00 10.00 5.00 10.00 -5.00 10.00 -5.00 10.00 -5.00 10.00 -5.00 10.00 -5.00 10.00 -5.00 10.00 -5.

図 2.1.2 BL-10B で測定した銀箔の XAFS 例。上から、10、20、50µm の厚さであ る。図 2.1.1 の計算に良く対応している。

2.1.2 蛍光法の場合

蛍光法の場合は第一部第 10 節に記した様に、 濃度が高くて厚さが薄い場合、 濃度が低くて厚い場合にのみ蛍光の信号は試料中の目的原子

の吸収係数にほぼ比例する。数式的には $[\mu_T(E) + \mu_T(E_f)]d << 1$ $[\mu_T(E) + \mu_T(E_f)]d >> 1$

となる。ここで、 $\mu_{T}(E)$ は入射 X 線に対する線吸収係数、 $\mu_{T}(E_{f})$ は蛍光 X 線に対する線吸収係数で、 *d* は X 線の光路長(45°配置の場合は厚さの 2 倍)である。概算を銅についてすると につい ては 1000Å の金属膜、 については数 mm 厚の 0.01 mol dm⁻³の水溶液ということになろう。第 一部 10.2 節に記した様に、この条件から外れると蛍光 XAFS は正しい結果を与えないので注意 が必要である。極端な場合は吸収端が消えてしまうことさえある[2, 3]。

2.2 透過法試料の厚さの算出

2.2.1 計算方法

X線の吸収は(2.2.1) 式で表される。

$$I/I_0 = \exp(-\mu_M \rho x) = \exp(-\mu x)$$
(2.2.1)

 I_0 :入射X線強度 I:透過X線強度

ho: 試料の密度(g/cm³) x: 試料の厚さ(cm) μ_{M} : 質量吸収係数(cm²/g)

 μ :線吸収係数(cm⁻¹)

通常 cgs 系で()内に示す単位で記述される。 xの単位をよく間違えるので注意すること。 混合物、化合物の場合は

$$\mu_{\mathbf{M}} = \mu_{\mathbf{M}\mathbf{i}} \mathbf{W}_{\mathbf{i}}$$

*μ*_{Mi} : 成分元素 i の質量吸収係数

*W*i : 成分元素 i の重量分率

質量吸収係数は表になったものが多いが、ここでは吸収端の直前、直後の吸収を求めるため Victoreen の式から求めてみる。Victoreen の式は(2.2.3)式で表される。

$$\mu_{\rm M} = \mathbf{C}\lambda^3 - \mathbf{D}\lambda^4 \tag{2.2.3}$$

(2.2.2)

Victoreen 式の係数を文献 4)から抜粋すると、

元素	C ₁	D_1	C_2	D_2
Cu	176.	48.3	15.6	0.779
Н	0.0127	0.466×10^{-5}		
0	3.18	0.0654		

ここで C_1 、 D_1 は各々の元素の K 吸収端より短波長側、 C_2 、 D_2 は L 吸収端と K 吸収端の間に適用される。

Cu²⁺の水溶液の例を考える。銅の吸収端でのX線の波長は 1.38Å であるので、この波長と上の表の値を式(2.2.3) に代入して以下のような質量吸収係数を得る。水分子については(2.2.2) 式を用いてそれぞれの元素の質量吸収係数より求めた。

 $\mu(H_2O)$ = 7.22 cm²/g $\mu(Cu, high E)$ = 287 cm²/g (C₁、 D₁より求めた値) $\mu(Cu, low E)$ = 38.2 cm²/g (C₂、 D₂より求めた値)

0.1 mol/l の場合

 $\mu t \text{ (high E)} = \{7.22(1-w) + 287w\}\rho x = 9.00x \text{ cm}^{-1}$

 $\mu t \text{ (low E)} = \{7.22(1-w) + 38.2w\}\rho x = 7.42x \text{ cm}^{-1}$

ここで w = 6.36/1000 = 6.36×10⁻³ (1リットルの溶液中に 0.1molの銅)

 ρ = 1 g/cm²

x = サンプルの厚さ (cm)

x = 1cm の場合は吸収端直前でのµt = 7.42、直後では 9.00 となり立ち上がりは 1.58 となる。こ れでは吸収が大き過ぎるので、吸収端直後のµt = 4.0 とすると、厚さは 4.4 mm となり、吸収端 直前のµt = 3.30、立ち上がりは 0.70 となり、測定可能である事が分かる。 0.01 mol/l の場合

 $\mu t \text{ (high E)} = \{7.22(1-w) + 287w\}\rho x = 7.40x \text{ cm}^{-1}$

 $\mu t \text{ (low E)} = \{7.22(1-w) + 38.2w\}\rho x = 7.24x \text{ cm}^{-1}$

ここで w = 0.636/1000 = 6.36 × 10⁻⁴ (1リットルの溶液中に 0.1molの銅)

 ρ = 1 g/cm²

x = サンプルの厚さ (cm)

x = 1cm の場合は吸収端直前での $\mu t = 7.24$ 、直後では 7.40 となり立ち上がりは 0.16 となる。これでは吸収が大き過ぎるので、吸収端直後の $\mu t = 4.0$ とすると、厚さは 5.4 mm となり、吸収端 直前の $\mu t = 3.91$ 、立ち上がりは 0.10 となり、測定可能であるが、かなり S/N 比を良くする努力をしないと、解析に耐えないデータとなるであろう(第一部図 10.1.1)。

このようにして求めた値(厚さ、吸収端の立ち上がり)は K 吸収端の場合実験値とかなり良 く合っているので本法で求めるのがよい。また、この例で分かるようにマトリックスによるX線 の吸収が無視出来ないことが多いので注意が必要である。Victoreen の表の古いものは三つの L 吸収端が分離されていないので注意を要する。また、粉末等の場合は正確な密度を推測すること は困難なので、 *px* を求めて、所与の断面積と試料の重量から適切な厚さの試料を調整する方が 良い。なおここで求めた厚さはあくまでも EXAFS 解析を念頭においたもので、同じ銅水溶液で も 1s 3d 構造に注目する場合の厚さは異なる。

2.2.2 SAMPLEM

2.2.1 節に記した計算は電卓等を用いて計算しても良いがかなり面倒である。このため試料の 厚さを求めるプログラム SAMPLEM を作成した。その概要と使用方法、入手方法を以下に記 す。

[計算方法]

McMaster の表に示された質量吸収係数から、試料の組成(原子数比、モル比) 密度に基づい て線吸収係数を求め、試料厚さの参考にする。吸収端前後に於ける吸収係数は同表のデータを用 い、他成分の吸収係数は同表に掲載されたデータ点間を Victoreen 式でフィットして用いた。出 力される厚さは統計的に S/N が最高になる試料の吸収端上の μt が 2.55 の場合、多くの場合に厚 さの限界である μt が 4 の場合及び吸収端の立ち上がり $\Delta \mu t$ が 1 の場合である。 粉末試料等の場 合は密度を 1g/cm² と仮に入力し ρt (単位断面積当りの質量)を求めた方が実用的である。当然 ながら、EXAFS や電子遷移に由来する吸収係数の変化は考慮されていないので、L端等の場合 で白色線等に注目する場合の厚さは変化する。

[入手法]

PF-XAFS のホームページ (http://pfwww.kek.jp/nomura/pfxafs/) の「ソフトウェアライブラ リ」からソースプログラム及び MS-DOS 用の実行形式をダウンロード出来る。

プログラムは FORTRAN-77 で記述してあるので、入出力関係を修正すれば他の計算機環境で も動作するはずである。

各ステーションの計算機にはインストールされている。SAMPLEM とタイプすれば起動する。

[使用例]

銅とモリブデン各1モルが溶けた水溶液を考える。密度は1g/cm³

従って組成は Cu 1.0mol Mo 1.0mol H₂O 55.5mol

A:¥USER> SAMPLEM ……… P C の場合はこの後データの読み込みに暫く時間がかかる LP OUTPUT (1)プリンタに出力する時は1、しない時は1以外 0 I= 1 NAME OF ATOM (A2) AND NUMBER EX: CU2.0 END:EN0.0 CU1.0原子名と原子数比を入力、原子名は大文字 I= 2 NAME OF ATOM (A2) AND NUMBER EX: CU2.0 END:EN0.0 MO1.0 I= 3 NAME OF ATOM (A2) AND NUMBER EX: CU2.0 END:EN0.0原子名は A2 で読んでいるので、一文字の時はスペースが必要 H 111.0 I= 4 NAME OF ATOM (A2) AND NUMBER EX: CU2.0 END:EN0.0 0 55.5 I= 5 NAME OF ATOM (A2) AND NUMBER EX: CU2.0 END:EN0.0 EN0.0データ入力を終了したときはこの様に入力 (原子名として EN、または数として 0.0 で入力終了) 1.0000入力データのリスト 1 CU 2 MO 1.0000 3 Н 111.0000 4 0 55.5000 ASSIGN X-RAY ABSORBING ATOM (1-- 4) OR CHANGE PARAMETER (OTHERS) 1どの原子の吸収端か指定、指定範囲以外の値を入力すると組成データの入 力に戻る WHICH EDGE: K(1), L1(2), L2(3), L3(4) 1どの吸収端か指定 **DENSITY G/CM3** 1.0密度を指定 1 CU 37.8700 288.9000 ……吸収端前後の質量吸収係数 2 MO 113.7751 ……銅吸収端での質量吸収係数 3 Η .2119 4 0 8.0151 RMUMA= 31.410 ……吸収端上での質量吸収係数 RMUMB= ……吸収端下での質量吸収係数 17.651MAX MUT=4 MUT=2.55 ==条件 == WHEN T1/MM =1.273 .812試料の厚さ吸収端上の*µt* 4.000 MUT(HIGH E) 2.550MUT(LOW E) 2.2481.433吸収端下の*µt*

== WHEN JUMP=1.0 ==

T2/MM =	.727
MUT(HIGH E)	2.283
MUT(LOW E)	1.283

1-- CHANGE ABSORPTION EDGE目的吸収端を変える

2-- CHENGE COMPOSITION試料の組成を変える

3-- ENDプログラムを終了する

2.3 試料調製上の注意点

XAFS は基本的には吸収スペクトルであるので、赤外吸収スペクトルや可視、紫外吸収スペクトル、メスバウアースペクトル用の試料を調製する時に払うのと同様な注意を払えば良い。即ち、 適切な厚さのピンホール等のない均一な試料を調製すれば良い。

適切な厚さの試料を調製する

2.2 節で記したように、光子の統計精 度を最高にする厚さ(最適厚さ)を求め ることが出来る。光子束が 10⁹ photons の様に十分に高い場合は、最適厚さから 多少外れても統計精度の点からはスペク トルには大きな影響を与えない。一方、 光子束が限られている場合は注意が必要 である(2.1 節参照)。

試料が厚過ぎる時は**高次光**が問題とな る。一般に高次光は基本波よりも試料を 透過し易く、試料が厚過ぎると、I 信号 は高次光が支配的になってしまう。この 様な条件では正しい XAFS スペクトル を得ることが出来ないことは自明であろ う。

厚過ぎる原因としては金属のように試料が濃厚で薄い試料が調製できない場合 と担持触媒試料や希薄溶液などのように 濃度が希薄で吸収端の立ち上がりの大き さを稼ぐために試料を厚くする場合があ る。どの程度の厚さを越えるとスペクト ルが歪むかは入射X線に含まれている高 次光の割合に依存するが(第一部 5.1 節) $\mu_{max} = 4$ が一つの指標となる。高 次光を抑制する方法としては二結晶の平 行性を調整する detune(第一部 4.2 節)



図 2.1.1 鉄箔の XAFS 例 BL-10B で Si(311) channel-cut 結晶を用いて測 定。鉄箔の厚さは 5 µm(a)、50 µm(b)。5 µm の場 合の計算上のµt は吸収端前で 0.21、後で 1.67。50 µm の場合はこの 10 倍。

とミラーを用いる方法(同 5.1 節)があるが、7keV 程度以上で detune、以下ではミラーの利用 が有効である。モノクロメーターの二結晶の平行度はエネルギー掃引中に僅かながら変化するの で、detune で高次光を抑制する場合は十分に高次光の割合を小さくしておく必要がある。 図 2.1.1 に前者の例として鉄箔のスペク トルを示す。(a) は厚さ 5 µm の鉄箔であ る。適切な厚さ(計算上の吸収端の立ち上 がりが 1.47、吸収端上のµt が 1.67)であ るのできれいなスペクトルが得られる。一 方(b)は厚さ 50 µm の鉄箔である。吸収端 より低エネルギー側ではきれいなスペクト ルが得られているが吸収端より高エネルギ ー側では EXAFS のスペクトルが観測され ない。この様に濃度の高い試料の場合厚さ の調整に注意を払う必要がある。従って EXAFS と吸収端前の構造(遷移金属の 1s 3d 等)やL端の XAFS と white line を

見る場合は異なった厚さの試料を調製する 必要があることもある。

希薄な試料のため吸収端の立ち上がりを 稼ごうとして厚くなった例を図 2.1.2 (a)





図 2.1.3 試料の調製法による k³χの変化。 a: 銅箔(6μm)、b: 銅粉末。



図 2.1.2 鉄箔とアルミニウム箔を重ねた XAFS の例。BL-10B で Si(311) channel-cut 結晶を用 いて測定。a: Fe 5 µm + Al 360 µm、b: Fe 2.5 µm + Al 180 µm。b のµt は吸収端前で 0.84、後で 4.35。 a はその倍。

に示す。ここではモデル試料として 5 µm の鉄箔と 360 µm のアルミニウム箔を重ねた試料を用いた。 吸収端より低エネルギー側の形状が上に凸になって おり、XAFS 領域に多くのグリッチ(glitch、4.5 節) が観測される。この様な場合は吸収端の立ち上がり は小さくなるが厚さを半分にすることに依って(b) の様に正常なスペクトルを得ることが出来る^{*}。

<u>むらのない試料を調製する</u>

試料に厚さむらがあると透過 X 線強度は試料の 薄い場所を透過した X 線によって支配されるため正 常なスペクトルを得ることが出来なくなる。

銅箔(6 μm)と銅粉末の k³χを比較して図 2.1.3 に 示す。両者とも良く似た形状をしているが (b)の方 が振幅が小さく、やや noisy である。もし (b)の様 な試料を標準として配位数を決定したら誤った結果

^{*}本来はミラーを用いて高次光を抑制し、もっと薄い試料を用意すべきである。1983年のデータとい うことでお許しを願う。



図 2.1.4 試料以外の物にビームの当たった例

a: 銅箔(6µm) + アルミニウム箔(60µm)にガムテープが一部重なった。

b: 銅箔(6µm) + アルミニウム箔(60µm)のみ。

を導くであろう。この様に厚さむらがあると XAFS 信号の振幅が減衰する。

厚さむらのある試料を振動させて、厚さむらの影響を消した例もある。この場合、確かに見か け上スペクトルはきれいになるが、I用電離箱で検出される信号は厚さの薄い部分を透過したX 線が支配し、正しい XAFS を得たことにはならない。

濃厚な試料の場合、400 mesh より十分に細かい粉末を用いることが推奨されている[5]。厚さ むらの影響は透過法で大きく、蛍光法、転換電子収量法ではそれ程大きく影響しない[6]。

ここでは厚さのむらについて例を示したが、組成のむらも結果的にX線の透過度のむらとなる ので同様の影響を与える。

全てのX線が試料を通ること

I₀ モニターで測定したのと異なった形状のビームが試料に入射したり、試料ホルダーでビーム を切ったりした場合は正しいスペクトルを得ることが出来なくなる。図 2.1.4 に銅箔とアルミニ ウム箔を重ねた試料の一部にガムテープを貼付けた例を示す。先に示したのと同じ銅箔であるに も拘らず glitch (4.5 節参照)が無視できなくなる。この様に適切な厚さの金属箔を用いてもス ペクトルに異常がある場合は光学系のセッティングか試料のビームに対する位置の不良を疑って みる必要がある。

この様な問題を避けるため、入射スリットの開口は試料より十分に小さくすべきである。

妨害吸収に注意

目的とする EXAFS のエネルギー域内に吸収端 を持つ原子を不純物として含む場合はこの不純物 原子の吸収端の為に解析できる領域が限られてく る。ここでは銅の水溶液中に溶けた微量の亜鉛の 例を図 2.1.5 に示す。試料はポリプロピレンの膜 で囲んだセルに入れたが、亜鉛はセルを押さえる ために用いた黄銅から溶出したと考えられる。即 ち僅かにセルから溢れた試料が黄銅に付き亜鉛を 溶かしセルに再び入ったと考えられる。此の例の 場合亜鉛の濃度が低いため生の EXAFS スペクト ルをいくら良く観察しても亜鉛の吸収端は観測さ れないが k³χ(k)を求める事によってはっきりして くる。もし不純物に気が付かなければ誤った解析 をする事になったであろう。この様に EXAFS の データの良否は $k^3 \chi(k)$ を求めないと分からない事 がしばしばある。

第一遷移金属のK吸収端とランタニドのL吸 収端はほぼ同じエネルギー領域に観測される。例 えばコバルトのK吸収端(7709.5eV)の周辺には EuLL,SmL,DyL,GdL,HoL,Tb



図 2.1.5 銅水溶液中の亜鉛不純物によるスペク トルの異常。

L と多くのL吸収端が観測される。この様な場合は EXAFS を適用できなくなる。逆にこのこ とを利用して微量分析を行うことも出来る[7]。

また、最近では少ないかも知れないが、水銀拡散ポンプを使用した履歴のある真空ラインで調製した Pt や Au の試料では Hg の吸収端が観測される。触媒の担体等は目的とする成分と比較して大量にあるので、微量不純物も無視出来ない。例えば ZrO₂ 担持触媒では Hf、グラファイト中の Fe 等も妨害となることがある。溶液試料等に用いる窓材中の不純物も問題となる。例えば、ガラス中の Zn、Be 中の Fe は顕著である。テープ中にも例えばスコッチテープには S、Cl、Br 等が(粘着剤に)含まれている[3]。

回折線に注意する

XAFS はX線の吸収を測定しているが、試料が結晶であれば回折現象も当然生じる。シリコン 単結晶等の上の薄膜やダイアモンドアンビル中の試料等については注意を要する。試料の方位を 変えることによって回折条件から逃れられる時もある。回折線によるスペクトルの歪は封入管を 用いた実験では分解能が低いため目だたないことがあるので注意を要する。強い回折線が SSD に入射すると検出器を壊すこともあるので注意が必要である。

スペクトル不良原因の判定

いくつかの装置の調整に由来するものは第1部第12節にまとめた。ここではスペクトルの不 良が試料に由来するか、装置の調整に由来するかの判定の一例を示す。最も簡単な方法は目的試 料と同程度の(真の)吸収を与える均一性の確かな模擬試料を作成し、そのスペクトルと比較す ることである。筆者らは目的の金属箔とアルミ箔を重ねたものをよく用いるがアルミ箔のみでも 構わない。要点は装置の条件(電離箱のガス、電流増幅器の利得等)を変えずに測定することで ある。

この模擬試料のスペクトルがきれいで、目的試料のスペクトルが汚い場合は試料の調製、位置 合わせに問題がある。この切り分けには Linagraph 等を用いてビームと試料の位置関係を再確 認する。試料がビームからはみ出したり、試料ホルダーがビームを切っている場合は試料の位置 を調整する。試料の厚さむらは試料を透過したX線ビームを Polaroid film で撮影することによ って確認出来る。また、試料を顕微鏡で観察しても良い。

どちらのスペクトルも汚い場合はそもそも測定が困難であるか、装置の調整に問題があるかの どちらかである。前者の例としては厚すぎる試料、薄すぎる濃度が想定される。後者の例として は、二結晶分光器の tune 調整の不良、メカ・制御の不良、高次光の除去が不十分、検出系の不 良等が考えられる。

2.4 試料の調製法

先にも記した様に XAFS の試料調製には赤外や可視・紫外吸収法等で既に確立している方法 を応用すれば良い[8]。

2.4.1 固相試料

種々の方法があるがいくつかの例を示すと

- イ) 微粉末をテープにまぶしたものを重ねて用いる。最も簡便な方法ではあるがどの程度均一な 試料が出来ているかという点で問題がある。微粉末の粒径や何枚くらいのテープを重ねるか でスペクトルの質が左右される。篩を使って 400 メッシュより充分に細かい(18µm 以下) 粉末を数層以上重ねるとかなり良いデータが得られるという報告がある[5]。
- ロ)Nujol 等と混合して用いる。これもイ同様粒径に依存する。
- 八)KBr 錠剤法を応用する。此の場合 KBr の替わりにポリエチレンや BN、セルロース等を用いる。試料の厚さを測定以前に予測できる点については上記の方法より優れている。従って PFに来る前に試料を調製できる。
- 二) 接着剤等と混合しフィルム状の試料を作る。此の方法も試料の厚さを予測できる。
- ホ)溶媒中に分散させた微粉末をろ過したろ紙やメンブレンフィルターを用いる[9]。細孔径の 異なるフィルターを二段に組み合わせて調整すると、所定の粒径より細かい粉末だけを沈積 出来る。
- へ)担持触媒等の希薄な系では Mylar や Kapton を窓とするセルを作り、その中へ試料を詰め る。ある程度の厚さが必要な場合はイ)、ロ)より良質の試料を調製できる。
- ト)蒸着の出来る試料は蒸着する。

2.4.2 液相試料

ポリエチレン袋に試料を詰めてそれを適当なスペーサーを介して窓材で挟み込む。また同様に して光路長を可変とする試料セルも報告されている[10-12]。ポリ袋の角が強度的に弱いので半 田コテを近づけて(接触はしないで)丸めると補強される。

やや厚めのポリプロピレン板の間にポリエチレン、ポリプロピレン等のスペーサを挟み込んで グリース等でシールしたものを金属板の間に挟み込む方法もある。また、適当な厚さのガラス板、 ポリマー板や金属板に穴を開け、Kapton 等の窓を貼り付ける方法もある。Mylar は水分を吸収 して膨潤するので適当でない。また、Kapton はアルカリ溶液に侵される。

濃厚な試料の場合には液膜法を用いるのがよいであろうが赤外や可視紫外分光の様に良い窓 がないことが問題である。窓にはポリプロピレン、カプトン、マイラー等が利用される。 いずれの方法をとる場合も溶媒との反応性に注意を払う必要がある。テフロンコートした Be 板等も窓材の候補になるであろう。

2.4.3 特殊条件下での測定

高温下での測定は電気炉等を作製すれば出来る。融解試料セルについての報告もある[13]。CO や H₂を実験ホールで開放系で用いることは出来ない。これらの気体を使う必要がある場合は化 学安全担当者と相談しその指示に従うこと。高圧ガス、高圧液体を実験用セル内で用いる時は人 事院規則 10-4 に従う。これらのガスを使用した例は「放射光を利用した触媒反応条件下におけ る in-situ XAFS 測定 (物質工学工業技術研究所 機能表面化学部 表面解析グループ)」の web site に詳しい。当該サイトへは PF-XAFS ホームページの XAFS 実験技術関係からリンク を張ってある。

微小試料の測定は試料の位置決め機構(第一部 11.6 節)を作ることによって容易に測定できる。この様な方法でダイヤモンドアンビルの中にX線を通した例もある[14]。筆者らが微量の金属内包フラーレンの実験を行った時は金属板に 0.7mm 程度の穴を開け、Kapton 窓を貼った上でこの穴に試料を詰めて測定した。この場合も試料とX線の位置合わせは重要である。これらの装置の準備は原則として実験者の責任に於て行う。

第3節 分光結晶の選択

各ビームラインの特徴は第一部第1節、6節に記したので、ここでは分光結晶の選択法について記す。一般的にあるエネルギー *E* のX線のエネルギー広がり d*E* は Bragg 角θとビームの角度 広がり(または分光結晶の角度変化)dθに対して

 $\mathrm{d}E = -E\,\cot\theta\,\mathrm{d}\theta$

で表される。この式から同じエネルギー E の X 線に対しては Bragg 角のが大きい程、dE が小さ くなることは自明である。図 3.1 に dのを 0.0005°と仮定した場合のエネルギー広がりの計算値 を示す。

		Si(111)	Si(3	B11)
K-edge	<i>E</i> /eV	θ/deg	dE/eV	<i>θ</i> /deg	dE/eV
Ti	4964.5	23.4688	0.10	49.6930	0.04
Fe	7111.2	16.1426	0.21	32.1666	0.10
Cu	8980.3	12.7185	0.35	24.9341	0.17
Ge	11103.6	10.2568	0.54	19.9353	0.27
Br	13470.0	8.4403	0.79	16.3235	0.40
Zr	17998.9	6.3065	1.42	12.1422	0.73
Mo	20003.9	5.6722	1.76	10.9094	0.91

表 3.1 d θを 0.0005°と仮定した場合の結晶面によるエネルギー分解能の計算例

実際的にはこの dのは光源の鉛直方向の広がりに由来する角度発散、受光スリットの縦幅に由来 する角度発散、分光結晶の回折強度曲線の幅のコンボリュートされたものである。

図 3.1~3.3 にいくつかの試料で分光結晶を変えて測定した XANES の例を示す。但しこれら のスペクトルは全て 1983 年頃に BL-10B で測定したものである。図 3.1 は KMnO4 の Mn K吸 収端である。 1s t₂(3d) とされる[15]鋭いピークのピークトップと連続吸収の高さを比べると Si(311) の方が分解能が良い事が分かるであろう。図 3.2 は銅の吸収端であるが気を付けないと 分解能の差に気が付かないであろう。図 3.3 は K₂MoO4の Mo K 吸収端であるが両モノクロメー ターの分解能の差は明らかであろう。従って XANES を研究する場合は強度より分解能を重視 して、強度の損失はデータの蓄積で補う方が良いであろう。なお、これらの図に記入したエネル ギー軸は較正していない。

図 3.4 には 1997 年の高輝度化前後に於ける K₂MoO₄の Mo K 吸収端の XANES の変化を示す。 これは光源ビームサイズによるエネルギー分解能の変化を反映している。また、第一部図 6.1.2 に I₀前スリット(受光スリット)の開口幅を変えた時の K₂MoO₄の Mo K 吸収端の XANES の変 化を示した。これらのスペクトルは BL-10B で Si(311)を用いて測定した。通常分光結晶を選択 した後は、光源サイズを調整することは出来ないので、受光スリットの幅だけが調整出来る自由 度となる。便宜的に受光スリットと表現し、BL-7C、10B では I₀前スリットがエネルギー分解 能を決めるが、BL-12C ではモノクロメーターとミラーの間にあるスリットが決めている。また BL-9A では調整の自由度はない。



図 3.1 KMnO₄の Mn K 吸収 端

(a) Si(311) (b) Si(111)を用い た場合。エネルギーは較正し ていない。

а

Ъ

図 3.2 Cu foil の Cu K 吸収端。 (a) Si(311) (b) Si(111)を用い た場合。エネルギーは較正し ていない。



а

b



図 3.3 K₂MoO₄の Mo K 吸収端 (a) Si(311) (b) Si(111)を用いた 場合。エネルギーは較正してい ない。

図 3.4 光源の大きさに依る エネルギー分解能の変化。 K₂MoO₄の XANES を Si(311) で測定。実線が高輝度化 (36nmrad,low ε)後、破線は 130 nmrad (norm ε)。やや 見難いが破線の方がプリエッ ジにピークの高さが低い。

第4節 信頼出来るデータを得るために

周知の様に EXAFS は目に見えない様な微小な信号であるので、測定条件、測定データの検討 を慎重に行なう必要がある。目に見える異常が無いからといって安心できない例は第2節にも いくつかあげた。また共同利用実験では所属研究機関の実験装置と異なり、データに異常を見つ けても再測定をするまでにはかなりの時間を要することが少なくないのでその場でデータの善し 悪しを判定する必要がある。ここではいくつかのテスト方法を紹介する。詳細は参考文献を読ん で頂きたい。

4.1 XAFS信号はどれくらい小さいか

EXAFS を解析する場合、生データでは振動が殆ど観測されないが、 $k^3\chi$ を見ると k の大きな所まで振動があることが確認できる例は度々経験することである(例えば図 2.1.5)。 $\mu_0 t$ = 1 と仮定すると、k = 15Å⁻¹ で $k^3\chi = 1$ Å⁻³の信号は μt の変化に直すと 3×10^{-4} という小さな量に相当する。従って、細心の注意を払う必要がある。

4.2 ブランクテスト

試料を入れずにまたは試料セルを試料と見なして XAFS 測定をするモードである。もしもモ ノクロメーターの回転精度が十分でないとブランクスペクトルにもうねりが出てくる。こういっ た事象はギアの偏心等に依って生じることがある。この様な場合はそれを XAFS 信号と思って 解析すると特定の距離を反映する位置にピークを与えることがある。実際にこの様なことは外国 の施設では観測されている[16]。もしこのことに注意していなければこの偽ピークを真のピーク と区別できずに解釈を誤る可能性もある。この様な事例はモノクロメーターの掃引角度範囲の大 きい低エネルギー側で見られることがある^{*}。

次に電離箱に用いるガスを交換した直後等で時間と共に僅かずつガスの組成が変化している様 な場合は各測定ブロックの間でutが不連続になったり、傾きが変化したりする。

またセルや電離箱等の窓材に不純物が入っていると吸収端が観測される。詳細は 2.3 節参照の こと。

4.3 簡単な性能テスト

通常の XAFS 測定では二つの電離箱の間に試料を置いて吸収を測定するが、入射スリットの 前に目的吸収端を持つ純金属を置くことによって様々な情報を得ることが出来る。本来はこの様 な配置をしても、上記のブランクと同様にスムースな曲線が得られるはずであるが、異常がある と見かけ上吸収端が見えてくる。この吸収端はエネルギーの増大と共に吸収係数が増大するよう に見える時もあるし逆に減少するように見える時もある。ここからは 入射ビーム中の高次光、 散乱光に関する情報、 計測系の非直線性に関する情報、 計測系のオフセットに関する情報が 含まれている[17]。

この実験は金属箔を置く替わりに入射スリット前に試料を置いた場合と置かない場合の吸収係 数を比較しても同様な情報が得られる。この実験は生データを比較するだけで済むので極めて便 利である。

^{*} モノクロメーターの構造上、2°周期のうねりが発生し易い。Si(111)を用いてCu付近を測定すると、掃引角 度は3°程度であるので、μ₀の処理で打ち消される場合が多い。

4.4 実験データの予備的な解析

この様にしても試料の不均一性や試料中の不純物、その他試料のミスアラインメント等による 異常は分からない。XAFS の測定原理は簡単に見えるので、XAFS 実験そのものが簡単であるか の様な錯覚をする事が少なくないが、先にも記したように EXAFS が極めて小さな信号である事 を考えるとその困難さが理解できよう。実験室で可視・紫外や赤外の吸収スペクトルを採ったこ とがある方ならば 10⁻⁴オーダーの精度を出すことが如何に大変か理解できよう。

生のスペクトルで異常が観測される程であれば、そのデータはまず使いものにならない。信頼 できるデータを得ようとするならば、測定した直後(ビームタイムの残っている内)に少なくと も *k*ⁿχを求めて異常の無いことを確認しておく必要がある。特に蛍光 XAFS 法で微量成分の解析 を行う場合は注意が必要である。

(株)リガクのご協力を得て、各実験ステーションには同社製の解析ソフト Rex(MS-DOS 環境)及び Rex2000(Windows 環境)をインストールしてあり予備的な解析に利用出来る。また、 Windows 端末はネットワークに接続されており、各端末には X 端末のエミュレーターがインストールされているので、直接または PF の計算機システム経由で所属機関のワークステーション 等にある解析ソフトを利用出来る。更にユーザーが PC 用に開発したソフトをノートブックパソコン等と共に持参すれば、日頃使い慣れたソフトで解析できる。

4.5 glitch

"Glitch"は XAFS スペクトルの I₀ 中に観測されるスパイク状の構造を指す[18,19]。モノクロ メーター結晶に於ける同時反射とチャンネルカット結晶の場合の遠回り反射が原因となりうる。 単結晶試料の測定をしている場合は回折に伴って偏光面の回転が生じるので、µt 上に不連続が 生じる。この様な場合は測定対象エ

ネルギー領域内に glitch が生じない 様に分光結晶の面内方位を選択する 必要がある。

単結晶でない一般的な試料の場合 は、実験条件が整っていれば I₀ に glitch があっても、μt 上に不連続が 生じ無いはずである(図 4.5.1 参照)。 その条件は

- 1)検出系のオフセットが正しく打 ち消され、リニアリティが十 分であること。
- 2)入射 X 線中の高次光、迷光が無 視しうること。
- 3) 試料の吸収が適当であること (厚過ぎないこと)。
- 4)試料が均一であること。

である。図 2.1.2a は 2、3 の条件が、

7 10⁵ 0.5 6 10⁵ 0 5 10⁵ 10 4 10⁵ ٥ſ -0.5 0 3 10⁵ 2 10⁵ - 1 (2^{+}) 1 10⁵ -1.5 8500 9000 9500 10000 E/eV

Cu1611

図 4.5.1 金属銅の XAFS スペクトルとその I_0 、I 信号。吸収端より低エネルギー側にいくつかのグ リッチが観測されるが、 μt では割り切れている。

図 2.1.3b は 4 の条件が満たされないために観測された glitch である。4)は入射ビームに中にエネルギー分布があり、試料に厚さむら(または組成むら)があると、glitch の位置が試料の薄い ところに当たった時と厚いところに当たった時で I 用電離箱に検出される X 線強度が変化するためµt 上に不連続が生じる。
Glitch は一見すると XAFS 実験の妨害と見えるが、逆に見ると、正しい条件で実験を行えて いるか否かの指標となる。また、I₀中の glitch の位置でモノクロメーターのエネルギー再現性 を確認したり、角度補正をすることも出来る。

4.6 thickness effect

"Thickness effect"と呼ばれる現象は試料の厚さが変わると得られるスペクトルの形状が変化 する現象全体を指している。主な原因は以下の通りである。詳しくは報文[6, 20, 20]を参照され たい。

- 1) 蛍光 XAFS の吸収端付近を観察するときに顕著な問題で、入射X線ビームのエネルギー広がりに由来している。簡単に記すと、試料に入射するX線のエネルギーを E と称すが、当然ながら幅を持っており、通常半値幅で 1eV とか 5eV とか呼んでいる。E が吸収端より低エネルギー側にあっても、吸収端より高いエネルギーの成分がその中にはある割合あり、その成分は試料からの蛍光X線を励起する。こうして、吸収端直前や途中にある微細な構造がかき消されてしまう。
- 2) 高次光、散乱光も主要な原因となる。特に低エネルギー域で透過法を用いて実験する場合に はキーポイントとなる。一般的に高次光に対する試料の吸収係数は基本波と比較して小さく、 高次光は試料を透過し易くなる。試料を透過したX線強度は ln exp(-µnt) (n は回折の次 数)で表されるので、試料が厚くなれば高調波が支配的になる。特に臨界エネルギー(PF の 偏向電磁石光源では 4keV、Spring-8 の偏向電磁石光源では 28.9keV)の 1/3 以下のエネルギ ーを使用する場合は、高次光の方が強くなるので、様々な方法(ミラーの利用、detune、 検出器のガスの選択、信号処理回路等)で高次光を抑制することが必要となる。得たい の 大きさに依存するが、一般的には信頼出来るデータを得るためには高次光の割合を 1×10⁻⁴ 以下に抑える必要がある。同時に試料による最大の(見かけではなく)実µt も4以下にす ることが必要である。
- いずれの場合も、厚さの異なる試料を測定してスペクトルの形状が重なれば問題ない。

第5節 吸収端・蛍光X線のエネルギー

5.1 吸収端のエネルギー

X線吸収端のエネルギーは以下の表に掲載されている。

J. A. Bearden, Rev. Mod. Phys., 39, 78 (1967).

B. K. Teo, "EXAFS: Basic Principles and Data Analysis" の付録

宇田川康夫編著 日本分光学会測定法シリーズ 26 「X線吸収微細構造 - XAFS の測定と解析」 (1993) 学会出版センター の付録

Center for X-ray Optics and Advanced Light Source "X-ray data booklet" (http://xdb.lbl.gov/ で申し込める。また同 web site には X 線に関連する各種情報が掲載されている)

Department of Physics at Uppsala University の X-ray WWW server(http://xray.uu.se/)でも 関連する情報を得られる。

この他にも「化学便覧」等多くのハンドブックに掲載されているが、吸収端の定義をきちんと定 めて、エネルギーを記載している例はない。従って、吸収端位置の目安程度に考えた方が良いで あろう。

シリコン結晶の格子定数として PF では従来 *a* = 5.4308 Å を用いていたが、近年では *a* = 5.4310196 Å (22.5 、真空中)が推奨されている[22]。実際の分光結晶の温度がこれと一致している保証もなく、この差は実用上は余り問題ないものと考えている。ただ、一連の研究には同じ定数を用いた方が良いであろう。従来の格子定数を用いて計算した主な吸収端についての Bragg angle を表 5.1 に、新しいデータに基づくものを表 5.2 に示す。ここにない原子については各自で計算して頂きたい。注意して頂きたいのは、これらの角度は単なる計算結果であり、ここに示された吸収端がすべて測定できるということではない。

参考のために、

 $2d\sin\theta = n\lambda$ 、 $E = hc/\lambda$ 従って 格子面間隔 dを Å 単位で、エネルギー E を eV 単位で表すと、

$$\theta = \sin^{-1}(\frac{nhc}{2dE}) = \sin^{-1}(\frac{12398.52}{2dE})$$

で計算出来る。

表 5.1 主な吸収端に関する Bragg 角の計算値(従来の格子定数 a = 5.4308 Å から計算)

7	atom	adaa	м	E/oV	Si(111)	Si(220)	Si(311)	Si(511)
L	atom	euge	111	L/CV	3.13551	1.9201	1.63747	1.04517
15	Р	K	30.97	2143.5	67.2760			
16	S	Κ	32.07	2470.5	53.1577			
17	Cl	Κ	35.45	2819.6	44.5237			
18	Ar	K	39.95	3202.9	38.1184			
19	K	K	39.10	3607.8	33.2307	63.4953		
20	Ca	K	40.08	4038.1	29.3153	53.0860	69.6423	
21	Sc	K	44.96	4489.0	26.1317	45.9908	57.4975	
22	Ti	K	47.88	4964.5	23.4688	40.5672	49.6930	
23	V	K	50.94	5463.9	21.2139	36.2208	43.8592	
24	Cr	K	52.00	5988.8	19.2770	32.6230	39.2096	82.0568
25	Mn	K	54.94	6537.6	17.6031	29.5941	35.3868	65.1302
26	Fe	K	55.85	7111.2	16.1426	27.0018	32.1666	56.5206
27	Co	K	58.93	7709.5	14.8596	24.7578	29.4107	50.2960
28	Ni	K	58.69	8331.7	13.7272	22.7996	27.0260	45.3898
29	Cu	K	63.55	8980.3	12.7185	21.0708	24.9341	41.3368
30	Zn	K	65.39	9660.7	11.8093	19.5239	23.0718	37.8768
31	Ga	K	69.72	10368.2	10.9931	18.1434	21.4164	34.8947
32	Ge	K	72.61	11103.6	10.2568	16.9042	19.9353	32.2884
33	As	K	74.92	11865.0	9.5922	15.7900	18.6073	29.9935
34	Se	K	78.96	12654.5	8.9886	14.7816	17.4079	27.9509
35	Br	K	79.90	13470.0	8.4403	13.8682	16.3235	26.1254
36	Kr	K	83.80	14324.4	7.9335	13.0260	15.3251	24.4609
37	Rb	K	85.47	15202.3	7.4727	12.2617	14.4203	22.9645
38	Sr	K	87.62	16107.0	7.0508	11.5631	13.5943	21.6075
39	Y	K	88.91	17038.0	6.6637	10.9233	12.8384	20.3726
40	Zr	K	91.22	17998.9	6.3065	10.3336	12.1422	19.2408
41	Nb	K	92.91	18986.9	5.9771	9.7904	11.5015	18.2034
42	Mo	K	95.94	20003.9	5.6722	9.2881	10.9094	17.2481
43	Тс	K	99	21047.3	5.3901	8.8239	10.3625	16.3683
44	Ru	K	101.1	22119.3	5.1282	8.3931	9.8551	15.5543
45	Rh	K	102.9	23219.8	4.8845	7.9926	9.3837	14.7999
46	Pd	K	106.4	23348.0	4.8576	7.9485	9.3317	14.7167
47	Ag	K	107.9	25516.5	4.4439	7.2691	8.5325	13.4414
48	Cd	K	112.4	26715.9	4.2441	6.9412	8.1467	12.8274
49 70	In	K	114.8	27942.0	4.0575	6.6352	7.7870	12.2556
50	Sn	K	118.7	29194.7	3.8831	6.3493	7.4509	11.7221
51	Sb	K	121.8	30486.0	3.7184	6.0793	7.1336	11.2190
52 52	Ie	K	127.6	31811.4	3.3033	5.8251	6.8350	10.7459
53	I V	K	126.9	33166.5	3.4175	5.5863	6.5545	10.3019
54	ле	K	131.3	34590.0	3.2/0/	5.3338	0.2830	9.8730
55 56		K	132.9	27452.0	5.1494 2.0261	5.14/5	0.0388 5.8017	9.4807
50	Ба	K V	137.3	28024.0	2.0108	4.9434	5.6017	9.1124
50	La	K V	138.9	30934.0 40452.0	2.9108	4.7307	5.3602	0.7020
30	Ce	K	140.1	40455.0	2.8014	4.3777	3.3700	0.4313
7.	atom	edge	м	E/eV	Si(111)	Si(220)	Si(311)	Si(511)
				, , ,	5.15551	1.9201	1.03/4/	1.04517
42	Mo	LIII	95.94	2523.4	51.5833			
43	Tc	LIII	99	2678	47.5851			
44	Ru		101.1	2837.7	44.1653			
45	Rh		102.9	3002.1	41.1914			
46	Pd		106.4	3173.0	38.5433			

47

LIII

Ag

107.9

3351.0

36.1575

74.4672

_					Si(111)	Si(220)	Si(311)	Si(511)
Z	atom	edge	М	E/eV	3.13560	1.92016	1.63751	1.04520
48	Cd	LIII	112.4	3537.6	33.9788	65.8751		
49	In	LIII	114.8	3730.2	32.0074	59.9437		
50	Sn	LIII	118.7	3928.8	30.2143	55.2635	74.4981	
51	Sb	LIII	121.8	4132.3	28.5845	51.3808	66.3720	
52	Te	LIII	127.6	4341.8	27.0886	48.0400	60.6872	
53	Ι	LIII	126.9	4558.7	25.7027	45.0912	56.1474	
54	Xe	LIII	131.3	4782.2	24.4206	42.4644	52.3409	
55	Cs	LIII	132.9	5011.3	23.2367	40.1107	49.0663	
56	Ва	LIII	137.3	5247.0	22.1361	37.9756	46.1811	
57	La	LIII	138.9	5484.0	21.1324	36.0672	43.6578	
58	Ce	LIII	140.1	5723.0	20.2104	34.3431	41.4159	
59	Pr	LIII	140.9	5963.0	19.3637	32.7818	39.4122	84.0933
60	Nd	LIII	144.2	6209.2	18.5672	31.3304	37.5693	72.7946
61	Pm	LIII	145	6460.5	17.8202	29.9832	35.8739	66.6489
62	Sm	LIII	150.4	6717.2	17.1177	28.7278	34.3058	62.0074
63	Eu	LIII	152.0	6980.6	16.4531	27.5493	32.8433	58.1779
64	Gd	LIII	157.3	7243.0	15.8410	26.4717	31.5132	54.9755
65	Tb	LIII	158.9	7515.3	15.2528	25.4425	30.2488	52.1141
66	Dy	LIII	162.5	7789.7	14.7032	24.4861	29.0787	49.5908
67	Ho	LIII	164.9	8067.6	14.1859	23.5904	27.9869	47.3246
68	Er	LIII	167.3	8357.5	13.6840	22.7253	26.9358	45.2107
69	Tm	LIII	168.9	8649.6	13.2134	21.9173	25.9568	43.2935
70	Yb	LIII	173.0	8944.1	12.7708	21.1602	25.0420	41.5411
71	Lu	LIII	175.0	9249	12.3431	20.4309	24.1626	39.8885
72	Hf	LIII	178.5	9557.7	11.9385	19.7430	23.3351	38.3587
73	Та	LIII	180.9	9876.6	11.5476	19.0804	22.5393	36.9089
74	W	LIII	183.9	10199.9	11.1768	18.4534	21.7877	35.5568
75	Re	LIII	186.2	10530.6	10.8215	17.8541	21.0702	34.2807
76	Os	LIII	190.2	10868.3	10.4814	17.2815	20.3859	33.0757
77	Ir	LIII	192.2	11212	10.1566	16.7359	19.7346	31.9391
78	Pt	LIII	195.1	11562	9.8460	16.2151	19.1135	30.8641
79	Au	LIII	197	11921.2	9.5465	15.7136	18.5163	29.8378
80	Hg	LIII	200.6	12286	9.2605	15.2356	17.9475	28.8666
81	T1	LIII	204.4	12660	8.9847	14.7751	17.4001	27.9376
82	Pb	LIII	207.2	13040.6	8.7204	14.3345	16.8768	27.0544
83	Bi	LIII	209	13426	8.4682	13.9146	16.3785	26.2175
88	Ra	LIII	226	15444	7.3551	12.0669	14.1899	22.5851
90	Th	LIII	232	16299	6.9673	11.4251	13.4311	21.3404
92	U	LIII	238	17165	6.6142	10.8415	12.7418	20.2153
7	otor	ada-	М	E/-V	Si(111)	Si(220)	Si(311)	Si(511)
L	atom	eage	M	E/ev	3.13551	1.9201	1.63747	1.04517
42	Mo	LII	95.94	2627.4	48.8072			
43	Tc	LII	99	2794.8	45.0259			
44	Ru	LII	101.1	2966.3	41.7994			
45	Rh	LII	102.9	3144.8	38.9538			
46	Pd	LII	106.4	3330.3	36.4182	75.8049		
47	Ag	LII	107.9	3525.8	34.1081	66.3069		
48	Cd	LII	112.4	3728.0	32.0285	60.0022		
49	In	LII	114.8	3939.3	30.1254	55.0438	73.9567	
50	Sn	LII	118.7	4157.3	28.3969	50.9515	65.5964	
51	Sb	LII	121.8	4381.9	26.8207	47.4601	59.7665	
52	Te	LII	127.6	4612.6	25.3809	44.4234	55.1618	
52								
53	Ι	LII	126.9	4854.0	24.0364	41.6934	51.2560	

Z	atom	edge	М	E/eV	Si(111) 3.13560	Si(220) 1.92016	Si(311) 1.63751	Si(511) 1.04520
55	Cs	LII	132.9	5358.1	21.6537	37.0540	44.9566	m
56	Ba	LII	137.3	5623.3	20.5848	35.0401	42.3183	
57	La	LII	138.9	5889.0	19.6169	33.2467	40.0064	
58	Ce	LII	140.1	6161.0	18.7178	31.6037	37.9149	74.3068
59	Pr	LII	140.9	6439.0	17.8817	30.0937	36.0124	67.0961
60	Nd	LII	144.2	6723.4	17.1015	28.6988	34.2697	61.9081
61	Pm	LII	145	7014.0	16.3725	27.4071	32.6673	57.7409
62	Sm	LII	150.4	7313.2	15.6850	26.1982	31.1766	54.1983
63	Eu	LII	152.0	7619.9	15.0384	25.0689	29.7912	51.1144
64	Gd	LII	157.3	7931.0	14.4355	24.0220	28.5126	48.4060
65	Tb	LII	158.9	8252.7	13.8613	23.0304	27.3061	45.9485
66	Dy	LII	162.5	8583.0	13.3178	22.0963	26.1735	43.7138
67	Ho	LII	164.9	8916.4	12.8112	21.2291	25.1252	41.6990
68	Er	LII	167.3	9262.2	12.3252	20.4005	24.1260	39.8203
69	Tm	LII	168.9	9617.1	11.8636	19.6161	23.1825	38.0792
70	Yb	LII	173.0	9976.1	11.4308	18.8829	22.3024	36.4809
71	Lu	LII	175.0	10344.8	11.0182	18.1858	21.4672	34.9852
72	Hf	LII	178.5	10736.2	10.6118	17.5010	20.6481	33.5361
73	Та	LII	180.9	11132.0	10.2304	16.8597	19.8823	32.1961
74	W	LII	183.9	11538.0	9.8667	16.2497	19.1549	30.9353
75	Re	LII	186.2	11954.0	9.5201	15.6694	18.4637	29.7476
76	Os	LII	190.2	12381.0	9.1889	15.1159	17.8052	28.6246
77	Ir	LII	192.2	12820.0	8.8716	14.5865	17.1761	27.5591
78	Pt	LII	195.1	13272.3	8.5670	14.0790	16.5736	26.5447
79	Au	LII	197	13736.1	8.2756	13.5943	15.9987	25.5823
80	Hg	LII	200.6	14215.0	7.9950	13.1280	15.4460	24.6617
81	TI	LII	204.4	14699.0	7.7301	12.6884	14.9253	23.7984
82	Pb	LII	207.2	15205.3	7.4712	12.2592	14.4174	22.9597
83	Bi	LII	209	15719.0	7.2257	11.8527	13.9365	22.1688
88	Ra	LII	226	18486.0	6.1396	10.0584	11.8176	18.7147
90	Th	LII	232	19683.0	5.7650	9.4409	11.0895	17.5383
92	U	LII	238	20945.0	5.4165	8.8673	10.4136	16.4505
7		1	м	\mathbf{r}	Si(111)	Si(220)	Si(311)	Si(511)
L	atom	edge	IVI	E/ev	3.13551	1.9201	1.63747	1.04517
41	Nb	LI	92.91	2710.0	46.8497			
42	Mo	LI	95.94	2881.0	43.3347			
43	Tc	LI	99	3055.0	40.3288			
44	Ru	LI	101.1	3233.0	37.7010			
45	Rh	LI	102.9	3417.0	35.3529			
46	Pd	LI	106.4	3607.0	33.2390	63.5208		
47	Ag	LI	107.9	3807.2	31.2859	57.9979		
48	Cd	LI	112.4	4019.0	29.4683	53.4500		
49	In	LI	114.8	4237.3	27.8137	49.6365	63.3119	
50	Sn	LI	118.7	4464.8	26.2841	46.3132	57.9882	
51	Sb	LI	121.8	4698.4	24.8855	43.4067	53.6857	
52	Te	LI	127.6	4939.7	23.5938	40.8140	50.0333	
53	Ι	LI	126.9	5192.0	22.3832	38.4509	46.8173	
54	Xe	LI	131.3	5452.8	21.2592	36.3063	43.9714	
55	Cs	LI	132.9	5721.0	20.2177	34.3568	41.4335	
56	Ba	LI	137.3	5996.0	19.2529	32.5789	39.1535	
57	La	LI	138.9	6268.0	18.3868	31.0038	37.1570	
58	Ce	LI	140.1	6548.0	17.5743	29.5425	35.3221	64.9346
59	Pr	LI	140.9	6834.0	16.8164	28.1924	33.6403	60.2174
60	Nd	LI	144.2	7129.4	16.1002	26.9273	32.0746	56.3001

Z	atom	edge	М	E/eV	Si(111) 3.13560	Si(220) 1.92016	Si(311) 1.63751	Si(511) 1.04520
61	Pm	LI	145	7436.0	15.4195	25.7336	30.6058	52.9065
62	Sm	LI	150.4	7747.8	14.7845	24.6273	29.2512	49.9561
63	Eu	LI	152.0	8060.7	14.1983	23.6118	28.0129	47.3778
64	Gd	LI	157.3	8386.4	13.6360	22.6426	26.8355	45.0122
65	Tb	LI	158.9	8716.7	13.1099	21.7399	25.7423	42.8794
66	Dy	LI	162.5	9054.8	12.6121	20.8893	24.7151	40.9234
67	Ho	LI	164.9	9399.4	12.1426	20.0897	23.7520	39.1265
68	Er	LI	167.3	9757.4	11.6906	19.3227	22.8301	37.4365
69	Tm	LI	168.9	10120.6	11.2655	18.6033	21.9672	35.8783
70	Yb	LI	173.0	10490.1	10.8638	17.9253	21.1555	34.4317
71	Lu	LI	175.0	10874.0	10.4758	17.2722	20.3747	33.0562
72	Hf	LI	178.5	11274.0	10.1002	16.6412	19.6216	31.7429
73	Та	LI	180.9	11682.0	9.7439	16.0440	18.9097	30.5130
74	W	LI	183.9	12099.6	9.4045	15.4761	18.2336	29.3544
75	Re	LI	186.2	12530.0	9.0787	14.9319	17.5865	28.2534
76	Os	LI	190.2	12972.0	8.7668	14.4119	16.9687	27.2093
77	Ir	LI	192.2	13423.0	8.4701	13.9177	16.3822	26.2238
78	Pt	LI	195.1	13883.0	8.1875	13.4478	15.8249	25.2924
79	Au	LI	197	14353.7	7.9172	12.9989	15.2931	24.4077
80	Hg	LI	200.6	14842.0	7.6552	12.5641	14.7782	23.5552
81	Tl	LI	204.4	15353.0	7.3989	12.1395	14.2757	22.7264
82	Pb	LI	207.2	15855.0	7.1634	11.7495	13.8146	21.9686
83	Bi	LI	209	16376.0	6.9344	11.3707	13.3668	21.2352
88	Ra	LI	226	19236.0	5.8994	9.6624	11.3506	17.9596
90	Th	LI	232	20464.0	5.5442	9.0775	10.6612	16.8485
92	U	LI	238	21771.0	5.2104	8.5284	10.0144	15.8096

表 5.2 主な吸収端に関する Bragg 角の計算値(従来の格子定数 *a* = 5.4310196 Å から計算)

Z	atom	edge	М	E/eV	Si(111) 3.13560	Si(220) 1.92016	Si(311) 1.63751	Si(511) 1.04520
15	Р	K	30.97	2143.5	67.2721			
16	S	К	32.07	2470.5	53.1555			
17	Cl	К	35.45	2819.6	44.5220			
18	Ar	K	39.95	3202.9	38.1171			
19	K	K	39.10	3607.8	33.2296	63.4917		
20	Ca	K	40.08	4038.1	29.3143	53.0836	69.6385	
21	Sc	K	44.96	4489.0	26.1308	45,9889	57,4953	
22	Ti	K	47.88	4964.5	23.4681	40.5657	49.6914	
23	V	K	50.94	5463.9	21.2132	36.2195	43.8579	
24	Cr	ĸ	52.00	5988.8	19 2764	32.6218	39 2085	82 0451
25	Mn	ĸ	54 94	6537.6	17 6026	29 5931	35 3858	65 1267
26	Fe	K	55.85	7111.2	16 1421	27.0009	32,1657	56 5181
20		ĸ	58.93	7709.5	14 8592	24 7570	29 4099	50.2940
27	Ni	K	58.69	8331.7	13 7268	27.7080	27.4077	15 3881
20	Cu	K	63 55	8080 3	12 7181	21.0701	27.0255	41 3353
2)	Zn	K K	65 30	0660.7	11 8000	10 5233	24.7555	41.5555
31	Ga	K K	60.72	10368.2	10.0027	19.5255	23.0712	3/ 8036
31	Ga	K K	72 61	11103 6	10.9927	16.0036	21.4130	34.0930
22		K V	74.02	11965.0	0.5010	15 7805	19.9340	20.0026
24	AS	K V	79.06	12654.5	9.3919	13.7093	17.0000	29.9920
54 25	Se De	K V	70.00	12034.3	0.9005	14./011	17.4073	27.9300
20	Dľ Va	K V	79.90 82.80	13470.0	0.4401 7.0222	12.00/0	10.5251	20.1240
20	Kr D1	K	83.80	14324.4	7.9333	13.0255	15.5247	24.4602
3/	KD	K	85.47	15202.3	7.4725	12.2613	14.4199	22.9638
38	Sr	K	87.62	16107.0	7.0506	11.5628	13.5940	21.6068
39	Y	K	88.91	17038.0	6.6635	10.9230	12.8381	20.3720
40	Zr	K	91.22	1/998.9	6.3063	10.3332	12.1419	19.2402
41	Nb	K	92.91	18986.9	5.9769	9.7901	11.5012	18.2029
42	Mo	K	95.94	20003.9	5.6720	9.2878	10.9092	17.2475
43	Te	K	99	21047.3	5.3900	8.8236	10.3622	16.3678
44	Ru	K	101.1	22119.3	5.1280	8.3928	9.8549	15.5539
45	Rh	K	102.9	23219.8	4.8844	7.9924	9.3835	14.7994
46	Pd	K	106.4	23348.0	4.8575	7.9482	9.3315	14.7163
47	Ag	K	107.9	25516.5	4.4438	7.2689	8.5323	13.4410
48	Cd	K	112.4	26715.9	4.2439	6.9409	8.1465	12.8271
49	In	K	114.8	27942.0	4.0574	6.6350	7.7868	12.2553
50	Sn	K	118.7	29194.7	3.8830	6.3491	7.4507	11.7218
51	Sb	K	121.8	30486.0	3.7183	6.0791	7.1335	11.2187
52	Te	K	127.6	31811.4	3.5632	5.8249	6.8348	10.7456
53	Ι	K	126.9	33166.5	3.4174	5.5862	6.5543	10.3016
54	Xe	K	131.3	34590.0	3.2766	5.3556	6.2835	9.8733
55	Cs	Κ	132.9	35987.0	3.1493	5.1471	6.0386	9.4864
56	Ba	Κ	137.3	37452.0	3.0260	4.9453	5.8016	9.1121
57	La	Κ	138.9	38934.0	2.9107	4.7566	5.5800	8.7625
58	Ce	Κ	140.1	40453.0	2.8013	4.5776	5.3699	8.4310
		1		T / T	Si(111)	Si(220)	Si(311)	Si(511)
Z	atom	edge	M	E/eV	3.13560	1.92016	1.63751	1.04520
42	Мо	LIII	95.94	2523.4	51.5812			
43	Tc	LIII	99	2678	47.5833			
44	Ru	LIII	101.1	2837.7	44.1637			
45	Rh	LIII	102.9	3002.1	41.1900			
46	Pd	LIII	106.4	3173.0	38.5420			
47	Ag	LIII	107.9	3351.0	36.1563	74.4608		

Z	atom	edge	М	E/eV	Si(111) 3.13560	Si(220) 1.92016	Si(311) 1.63751	Si(511) 1.04520
48	Cd	LIII	112.4	3537.6	33.9777	65.8711		
49	In	LIII	114.8	3730.2	32.0064	59.9406		
50	Sn	LIII	118.7	3928.8	30.2134	55.2609	74.4931	
51	Sb	LIII	121.8	4132.3	28.5836	51.3786	66.3688	
52	Te	LIII	127.6	4341.8	27.0877	48.0380	60.6847	
53	Ι	LIII	126.9	4558.7	25.7019	45.0894	56.1453	
54	Xe	LIII	131.3	4782.2	24.4199	42.4627	52.3391	
55	Cs	LIII	132.9	5011.3	23.2360	40.1092	49.0647	
56	Ba	LIII	137.3	5247.0	22.1355	37.9742	46.1796	
57	La	LIII	138.9	5484.0	21.1317	36.0659	43.6565	
58	Ce	LIII	140.1	5723.0	20.2098	34.3419	41.4146	
59	Pr	LIII	140.9	5963.0	19.3631	32.7806	39.4110	84.0774
60	Nd	LIII	144.2	6209.2	18.5667	31.3293	37.5682	72.7893
61	Pm	LIII	145	6460.5	17.8197	29.9822	35.8729	66.6451
62	Sm	LIII	150.4	6717.2	17.1172	28.7268	34.3048	62.0043
63	Eu	LIII	152.0	6980.6	16.4526	27.5484	32.8424	58.1752
64	Gd	LIII	157.3	7243.0	15.8405	26.4708	31.5123	54.9732
65	Tb	LIII	158.9	7515.3	15.2524	25.4417	30.2480	52.1120
66	Dv	LIII	162.5	7789.7	14.7027	24.4853	29.0779	49.5888
67	Ho	LIII	164.9	8067.6	14.1855	23.5896	27.9861	47.3228
68	Er	LIII	167.3	8357.5	13.6836	22.7245	26.9351	45.2091
69	Tm	LIII	168.9	8649.6	13.2130	21.9165	25.9562	43.2920
70	Yh	LIII	173.0	8944 1	12.7705	21.5105	25.0413	41 5396
71	Lu	LIII	175.0	9249	12.3427	20 4302	24 1620	39 8871
72	Hf	LIII	178.5	9557.7	11 9381	19 7424	23 3345	38 3574
73	та Та	LIII	180.9	9876.6	11.5501	19.0798	22.5545	36 9077
74	W	I III	183.9	10199.9	11.1764	18 4528	22.3300	35 5556
75	Re		186.2	10177.7	10.8212	17 8535	21.7671	34 2796
76		LIII	190.2	10868 3	10.0212	17 2810	20.3854	33 0746
77	Ir	I III	192.2	11212	10.1563	16 7354	19 7341	31 9381
78	II Pt		195.1	11562	9 8457	16 2145	19 1131	30 8631
79	Δ11	I III	195.1	11921.2	9 5463	15 7131	18 5159	29.8368
80	Ha	I III	200.6	12286	9 2603	15 2351	17 9471	29.8500
81			200.0	12200	9.2003	14 7746	17 3007	20.0057
82	Ph	I III	204.4	13040.6	8 7201	14 3340	16.8764	27.0536
83	Bi		207.2	13/26	8 /679	13 01/1	16 3781	27.0550
88	Di Ra		20)	15444	7 35/0	12.0665	1/ 1805	20.2107
00	Ка Th		220	16200	6 9671	11.4247	13 /308	22.3044
02	II		232	17165	6.6140	10.8412	12 7415	21.5576
)2	0	LIII	250	17105	0.0140	10.0412	12.7415	20.2147
Z	atom	edge	М	E/eV	Si(111)	Si(220)	Si(311)	Si(511)
10			05.04	0.07.4	40.0054	1.92010	1.03731	1.04320
42	Mo		95.94	2627.4	48.8054			
43	lc	LII	99	2794.8	45.0242			
44	Ru	LII	101.1	2966.3	41.7980			
45	Rh	LII	102.9	3144.8	38.9524			
46	Pd		106.4	3330.3	36.4170	75.7978		
47	Ag	LII	107.9	3525.8	34.1070	66.3028		
48	Cd	LII	112.4	3728.0	32.0275	59.9991		
49	In	LII	114.8	3939.3	30.1245	55.0413	73.9519	
50	Sn	LII	118.7	4157.3	28.3960	50.9493	65.5933	
51	Sb	LII	121.8	4381.9	26.8199	47.4581	59.7641	
52	Te	LII	127.6	4612.6	25.3801	44.4217	55.1598	
53	Ι	LII	126.9	4854.0	24.0356	41.6918	51.2542	
54	Xe	LII	131.3	5103.7	22.7914	39.2409	47.8826	

Z	atom	edge	М	E/eV	Si(111) 3.13560	Si(220) 1.92016	Si(311) 1.63751	Si(511) 1.04520
55	Cs	LII	132.9	5358.1	21.6530	37.0526	44.9552	
56	Ba	LII	137.3	5623.3	20.5842	35.0388	42.3170	
57	La	LII	138.9	5889.0	19.6163	33.2455	40.0052	
58	Ce	LII	140.1	6161.0	18.7173	31.6026	37.9138	74.3009
59	Pr	LII	140.9	6439.0	17.8812	30.0926	36.0114	67.0922
60	Nd	LII	144.2	6723.4	17.1009	28.6978	34.2688	61.9051
61	Pm	LII	145	7014.0	16.3720	27.4062	32.6664	57.7383
62	Sm	LII	150.4	7313.2	15.6846	26.1973	31.1757	54.1960
63	Eu	LII	152.0	7619.9	15.0380	25.0681	29.7904	51.1124
64	Gd	LII	157.3	7931.0	14.4350	24.0212	28.5118	48.4042
65	Tb	LII	158.9	8252.7	13.8609	23.0296	27.3054	45.9468
66	Dy	LII	162.5	8583.0	13.3174	22.0955	26.1728	43.7123
67	Ho	LII	164.9	8916.4	12.8108	21.2284	25.1245	41.6975
68	Er	LII	167.3	9262.2	12.3249	20.3998	24.1254	39.8189
69	Tm	LII	168.9	9617.1	11.8633	19.6154	23.1819	38.0779
70	Yb	LII	173.0	9976.1	11.4305	18.8823	22.3018	36.4797
71	Lu	LII	175.0	10344.8	11.0179	18.1852	21.4667	34.9840
72	Hf	LII	178.5	10736.2	10.6115	17.5004	20.6476	33.5350
73	Та	LII	180.9	11132.0	10.2301	16.8592	19.8818	32.1951
74	W	LII	183.9	11538.0	9.8664	16.2492	19.1544	30.9343
75	Re	LII	186.2	11954.0	9.5198	15.6689	18.4632	29.7467
76	Os	LII	190.2	12381.0	9.1886	15.1154	17.8047	28.6237
77	Ir	LII	192.2	12820.0	8.8714	14.5861	17.1757	27.5582
78	Pt	LII	195.1	13272.3	8.5667	14.0786	16.5732	26.5439
79	Au	LII	197	13736.1	8.2754	13.5939	15.9983	25.5815
80	Hg		200.6	14215.0	7.9948	13.1276	15.4456	24.6609
81	TI		204.4	14699.0	7.7299	12.6880	14.9250	23.7977
82	Pb		207.2	15205.3	7.4710	12.2588	14.41/0	22.9590
83	B1 D-		209	15/19.0	7.2255	11.8523	13.9362	22.1681
88	ка		226	18486.0	6.1395	10.0581	11.81/3	18./141
90			232	19083.0	5.7048	9.4400	10.4124	17.5578
92	U	LII	238	20943.0	3.4104	8.80/1	10.4154	10.4300
7	atom	edge	М	E/eV	Si(111)	Si(220)	Si(311)	Si(511)
	utom	eage	101		3.13560	1.92016	1.63/51	1.04520
41	Nb	LI	92.91	2710.0	46.8480			
42	Mo	LI	95.94	2881.0	43.3332			
43	Tc	LI	99	3055.0	40.3274			
44	Ru	LI	101.1	3233.0	37.6998			
45	Rh		102.9	3417.0	35.3517	60 5150		
46	Pd		106.4	3607.0	33.2379	63.5172		
4/	Ag		107.9	3807.2	31.2849	57.9950		
48	Ca La		112.4	4019.0	29.4674	53.4476	(2,2001	
49 50	In Ca		114.8	4257.5	27.8128	49.0344	03.3091 57.0850	
50	Sn Sh		118.7	4404.8	20.2833	40.3113	57,9859	
51	50 To		121.0	4098.4	24.0047	45.4050	50.0217	
52	Ie I		127.0	4939.7 5102.0	25.5951	40.8124	JU.UJI/	
55 51	I Va		120.9	5192.0 5452.0	22.3820 21.2585	36 2050	40.0138	
54			131.3	5721 0	21.2303	34 2555	43.9701	
55	C3 Ra		132.9	500K N	10 2522	37 5778	30 1521	
57	Ба Гя	LI	137.5	6268.0	18 3862	31 0027	37 1559	
58	Ce	II	140.1	6548.0	17 5737	29 5415	35 3212	64 9311
59	Pr	LI	140.9	6834 0	16.8159	28.1914	33.6393	60,2145
60	Nd	LI	144.2	7129.4	16.0997	26.9264	32.0737	56.2976

		-	. -		Si(111)	Si(220)	Si(311)	Si(511)
Z	atom	edge	М	E/eV	3.13560	1.92016	1.63751	1.04520
61	Pm	LI	145	7436.0	15.4190	25.7327	30.6049	52.9043
62	Sm	LI	150.4	7747.8	14.7840	24.6265	29.2504	49.9541
63	Eu	LI	152.0	8060.7	14.1979	23.6110	28.0122	47.3760
64	Gd	LI	157.3	8386.4	13.6356	22.6419	26.8348	45.0105
65	Tb	LI	158.9	8716.7	13.1095	21.7392	25.7416	42.8779
66	Dy	LI	162.5	9054.8	12.6118	20.8886	24.7145	40.9220
67	Но	LI	164.9	9399.4	12.1422	20.0891	23.7514	39.1251
68	Er	LI	167.3	9757.4	11.6903	19.3221	22.8296	37.4352
69	Tm	LI	168.9	10120.6	11.2652	18.6027	21.9667	35.8772
70	Yb	LI	173.0	10490.1	10.8634	17.9247	21.1549	34.4305
71	Lu	LI	175.0	10874.0	10.4755	17.2716	20.3742	33.0551
72	Hf	LI	178.5	11274.0	10.0999	16.6406	19.6211	31.7418
73	Та	LI	180.9	11682.0	9.7436	16.0435	18.9092	30.5120
74	W	LI	183.9	12099.6	9.4042	15.4756	18.2332	29.3534
75	Re	LI	186.2	12530.0	9.0784	14.9314	17.5860	28.2525
76	Os	LI	190.2	12972.0	8.7666	14.4114	16.9683	27.2084
77	Ir	LI	192.2	13423.0	8.4698	13.9173	16.3818	26.2230
78	Pt	LI	195.1	13883.0	8.1872	13.4473	15.8245	25.2916
79	Au	LI	197	14353.7	7.9170	12.9985	15.2927	24.4070
80	Hg	LI	200.6	14842.0	7.6549	12.5637	14.7779	23.5545
81	Tl	LI	204.4	15353.0	7.3987	12.1391	14.2754	22.7257
82	Pb	LI	207.2	15855.0	7.1632	11.7492	13.8143	21.9680
83	Bi	LI	209	16376.0	6.9342	11.3703	13.3665	21.2346
88	Ra	LI	226	19236.0	5.8992	9.6621	11.3503	17.9590
90	Th	LI	232	20464.0	5.5441	9.0772	10.6610	16.8480
92	U	LI	238	21771.0	5.2103	8.5281	10.0141	15.8092

5.2 蛍光X線のエネルギー

蛍光 XAFS 用電離箱を用いて蛍光 XAFS スペクトルを測定する時には散乱 X線を除くために フィルターを用いることが多い。適切なフィルターを選択するためには蛍光 X線のエネルギーを 知っておく必要がある。ここには名古屋大学工学部の田渕雅夫氏の提供された表を掲載する。 この他に、桜井健次氏からの情報として、下記サイトにも情報が掲載されている。

http://xray.uu.se/hypertext/XREmission.html

表 5.2.1 蛍光 X 線と吸収端のエネルギー(名古屋大学工学部 田渕雅夫氏提供のデータを編集)

		蛍光 X 線								吸収	端	
atom	Ζ	Κα2	Κα1	Κβ	La2	La1	Lβ1	Lβ2	K	LIII	LII	LI
F	9	67	6.8						692			
Ne	10	84	8.6	857.9					874			
Na	11	10	41	1071.1				1	1080	50		
Mg	12	1496.2	14967	1302.2					1303	50		
AI Si	13	1480.5	1480.7	1557.4				I	1559	98		
P	15	2012.7	2013 7	2139					2143	128		
S	16	2306.6	2307.8	2464					2471	162	163	193
Cl	17	2620.8	2622.4	2815.6					2820	201	202	238
Ar	18	2955.6	2957.7	3190.5					3203	244	246	287
K	19	3311.1	3313.8	3589.6					3608	292	295	341
Ca	20	3688.1	3691.7	4012.7				,	4038	346	350	399
Sc	21	4086.1	4090.6	4460.5					4497	407	411	462
Ti	22	4504.9	4510.8	4931.8					4965	456	462	530
V C	23	4944.6	4952.2	5427.3				I	5465	515	523	604
Cr Mn	24	5405.5 5887 7	5808.8	5946.7				1	5989	574	584 656	079 762
Fe	25	6390.8	6403.8	7058					7113	709	722	849
Co	20	6915.3	6930.3	7649.4				1	7710	783	798	929
Ni	28	7460.9	7478.2	8264.7					8332	858	877	1011
Cu	29	8027.8	8047.8	8905.3					8984	935	954	1100
Zn	30	8615.8	8638.9	9572					9663	1024	1047	1200
Ga	31	9224.8	9251.7	10264.2					10375	1142	1168	1300
Ge	32	9855.3	9886.4	10982.1					11109	1212	1244	1413
As	33	10508	10543.7	11726.2				l	11875	1322	1358	1529
Se	34	11181.4	11222.4	12495.9				1	12664	1431	1472	1660
Br	35	11877.6	11924.2	13291.4					13478	1552	1599	1790
NT Dh	20	12398	12049	14112				l	14325	10/0	1/30	1920
KU Sr	38	13333.0	1/165	15835 7					15205	1003	2004	2004
Y	39	14882.9	14958.4	16737.8					17040	2096	2004	2387
Zr	40	15690.9	15775.1	17667.8	2039.9	2042.4	2124.4	2219.4	17999	2223	2308	2533
Nb	41	16521	16615.1	18622.5	2163	2165.9	2257.4	2367	18989	2371	2467	2700
Mo	42	17374.3	17479.3	19608.3	2289.9	2293.2	2394.8	2518.3	20003	2542	2630	2869
Tc	43	18250.8	18367.1	20619		2424.0	2536.8		21053	2679	2800	3050
Ru	44	19150.4	19279.2	21656.8	2554.3	2558.6	2683.2	2836	22120	2838	2969	3228
Rh	45	20073.7	20216.1	22723.6	2692.1	2696.7	2834.4	3001.3	23226	2994	3140	3405
Pd	46	21020.1	21177.1	23818.7	2833.3	2838.6	2990.2	3171.8	24353	3180	3339	3615
Ag	4/	21990.3	22162.9	24942.4	2978.2	2984.3	3150.9	25291	25521	33/4	3548	3829
Cu In	40	22984.1	23175.0	20095.5	3120.9	3135.7	3/87 2	3713.8	20/14	3731	3930	4020
Sn	50	25044	25271 3	28486	3435.4	3444	3662.8	3904.9	29192	3910	4140	4446
Sb	51	26110.8	26359.1	29725.6	3595.3	3604.7	3843.6	4100.8	30492	4136	4392	4709
Te	52	27201.7	27472.3	30995.7	3758.8	3769.6	4029.6	4301.7	31814	4346	4622	5954
Ι	53	28317.2	28612	32294.7	3269	3937.7	4220.7	4507.5	33167	4558	4856	5188
Xe	54	29458	29779	33624	4097	4109.9	4417	4719	34583	4779	5101	5451
Cs	55	30625.1	30972.8	34986.9	4272.2	4286.5	4619.8	4935.9	35968	5013	5361	5707
Ba	56	31817.1	32193.6	36378.2	4450.9	4466.3	4827.5	5156.5	37411	5249	5630	5951
La	57	33034.1	33441.8	37801	4634.2	4651	5042.1	5383.5	38938	5489	5903	6265
Ce	58	34278.9	34/19.7	39257.3	4823.5	4840.2	5262.2	5613.4	40450	5727	6170	6557
PT Nd	59 60	35350.2	30020.3	40/48.2	5015.5 5207 7	5035./	5488.9 5701 6	5850	41999	5900 6214	044/ 6720	0838
Pm	61	38171 2	38724 7	43876	5407.8	5230.4 5232 5	5961	6330	45199	6458	7021	7431
Sm	62	39522.4	40118 1	45413	5608.4	5636.1	6205.1	6587	46856	6719	7317	7743
Eu	63	40901.9	41542.2	47037.9	5816.6	5845.7	6456.4	6843.2	48524	6982	7625	8060
Gd	64	42308.9	42996.2	48697	6025	6057.2	6713.2	7102.8	50235	7249	7943	8384
Tb	65	43744.1	44481.6	50382	6238	6272.8	6978	7366.7	52005	7518	8259	8714
Dy	66	45207.8	45998.4	52119	6457.7	6495.2	7247.7	7635.7	53787	7793	8588	9054
Но	67	46699.7	47546.7	53877	6679.5	6719.8	7525.3	7911	55621	8072	8919	9397
Er	68	48221.1	49127.7	55681	6905	6948.7	7810.9	8189	57478	8360	9572	9755

	蛍光 X 線									吸収端			
atom	Z	Κα2	Κα1	Κβ	La2	La1	Lβ1	Lβ2	Κ	LIII	LII	LI	
Tm	69	49772.6	50741.6	57517	7133.1	7179.9	8101	8468	59349	8658	9621	10103	
Yb	70	51354	52388.9	59370	7367.3	7415.6	8401.8	8758.8	61316	8947	9986	10494	
Lu	71	52965	54069.8	61283	7604.9	7655.5	8709	9048.9	63320	9246	10353	10874	
Hf	72	54611.4	55790.2	63234	7844.6	7899	9022.7	9347.3	65321	9565	10752	11285	
Та	73	56227	57352	65223	8087.9	8146.1	9343.1	9651.8	67417	9880	11143	11687	
W	74	57981.7	59318.2	67244.3	8335.2	8397.6	9672.4	9961.5	69496	10197	11539	12096	
Re	75	59717.7	61140.3	69310	8586.2	8652.5	10010	10275.2	71623	10528	11961	12522	
Os	76	61486.7	63000.5	71413	8841	8911.7	10355.3	10598.5	73886	10858	12382	12973	
Ir	77	63286.7	64895.6	73560.8	9099.5	9175.1	10708.3	10920.3	76108	11205	12821	13413	
Pt	78	65122	66832	75748	9361.8	9442.3	11070.7	11250.5	78369	11549	13263	13866	
Au	79	66989.5	68803.7	77984	9628	9713.3	11442.3	11584.7	80821	11913	13733	14353	
Hg	80	68895	70819	80253	9897.6	9988.8	11822.6	11924.1	83097	12278	14122	14843	
Tl	81	70831.9	72871.5	82576	10172.8	10268.5	12213.3	12271.5	85681	12650	14697	15346	
Pb	82	72804.2	74969.4	84936	10449.5	10551.5	12613.7	12622.6	88054	13030	15203	15864	
Bi	83	74814.8	77107.9	87343	10730.9	10838.8	13023.5	12979.9	90562	13404	15712	16389	
Ро	84	76862	79290	89800	11015.8	11130.8	13447	13340.4	93148	13807	16232	16933	
At	85	78950	81520	92300	11304.8	11426.8	13876	0	95737	14207	16784	17482	
Rn	86	81070	83780	94870	11597.9	11727	14316	14080	98475	14606	17333	18052	
Fr	87	83230	86100	97470	11895	12031.3	14770	14450	101126	15016	17893	18632	
Ra	88	85430	88470	100130	12196.2	12339.7	15235.8	14841.4	103923	15437	18474	19234	
Ac	89	87670	90884	102850	12500.8	12652	15713	0	106695	15856	19074	19843	
Th	90	89953	93350	105609	12809.6	12968.7	16202.2	15623.7	109814	16274	19676	20455	
Ра	91	92287	95868	108427	13122.2	13290.7	16702	16024	112403	16716	20305	21103	
U	92	94665	98439	111300	13438.8	13614.7	17220	16428.3	115009	17158	20946	21762	

5.3 蛍光XAFS用フィルターの例

蛍光 XAFS 実験で散乱 X 線を抑制するために用いるフィルターの例を表 5.3.1 に示す。大面積のフィルターの製作法は J. Wong, *Nucl. Instrum. methods*, **224**, 303 (1984)にある。PF が所有していないフィルターを必要とする場合は、必要とする方が製作して、他のユーザーのために提供して下さることを期待する。

target elements	<i>E</i> (K-edge)/eV	<i>E</i> (Kα)/eV	candidates of filters
K	3607.8	3313.8	
Ca	4038.1	3691.7	
Sc	4489	4090.6	
Ti	4964.5	4510.8	
V	5463.9	4952.2	Ti
Cr	5988.5	5414.7	V
Mn	6537.6	5898.8	Cr
Fe	7111.2	6403.8	Mn
Co	7709.5	6930.3	Fe
Ni	8331.7	7478.2	Co
Cu	8980.3	8047.8	Ni
Zn	9660.7	8638.9	Cu
Ga	10368.2	9251.7	Zn
Ge	11103.6	9886.4	Ga
As	11865	10543.7	Ge
Se	12654.5	11222.4	As
Br	13470	11924.2	Se
Kr	14324.4	12649	Se, Br ^{#1}
Rb	15202.3	13395.3	Br ^{#1} , Kr ^{#3}
Sr	16107	14165.0	Kr ^{#3} , Rb ^{#3}
Y	17038	14958.4	Rb ^{#3} , Sr ^{#3}
Zr	17998.9	15775.1	Sr ^{#3} , Y ^{#3}
Nb	18986.9	16615.1	$Y^{#3}, Zr^{#3}$
Mo	20003.9	17479.3	Zr ^{#3} , Nb ^{#3}

表 5.3.1. 蛍光 XAFS 用散乱線抑制フィルターの候補

Tc	21047.3	18367.1	Nb ^{#3} , Mo ^{#2}
Ru	22119.3	19279.2	Mo ^{#2} , Tc ^{#3}
Rh	23219.8	20216.1	Tc ^{#3} , Ru ^{#1}
Pd	24348	21177.1	$Ru^{#1}, Rh^{#3}$
Ag	25516.5	22162.9	Rh ^{#3} , Pd ^{#3}
Cd	26715.9	23173.6	Rh ^{#3} , Pd ^{#3} , Ag ^{#3}
In	27942.0	24209.7	Pd ^{#3} , Ag ^{#3} , Cd ^{#3}
Sn	29194.7	25271.3	Ag ^{#3} , Cd ^{#3} , In ^{#3}
Sb	30486.0	26359.1	Cd ^{#3} , In ^{#3} , Sn ^{#3}
Te	31811.4	27201.7	In ^{#3} , Sn ^{#3} , Sb ^{#3}

#1: BL-9A のみ、#2:BL-12C のみ、#3:PF にはない。

第6節 検出器用ガスの選択

電離箱の構造については第一部 7.2 節に記した。7.2 節に記した様に選択するガスの種類によって動作条件が異なってくる。また第二部 2.1 節に記した光子統計の議論からは I₀ での検出効率が 0.245 で最高の S/N 比を与えることが分かる。これらに注意して正しく電離箱を使用することは試料の調製と共に XAFS 実験データの質を決めるものとなる。

6.1 バックグラウンド吸収係数

放射光を用いて XAFS を測定する場合、通常絶対的な吸収係数ではなく見かけの吸収係数を 以下の式を用いて求めている。

 $\mu t = \ln(I_0/I)$

これは更に詳しく見ると、増幅器の利得(G)、Ⅰ。用イオンチェンバーのガスの吸収係数(μ_F)、 試料の吸収係数(μ_S)、Ⅰ用イオンチェンバーのガスの吸収係数(μ_R)及びそれらの長さ(厚さ) (f,s,r)を用いて以下の様に表される。⁴)

 $\ln(i_0/i) = \ln(G_F/G_R) + \ln\{1 - \exp[-\mu_F()f] - \ln\{1 - \exp[-\mu_R()r]\}$

$$+ \mu_{F}()f + \mu_{S}()s$$

= background() + μ_s ()s

但しここではこれら以外の物質(空気等)による吸収は無視した。また電離箱の内部構造も無視した。此の式からも分かる様に観測された μt を Victoreen 式を用いてフィットする事には何ら根拠がない。また I₀用電離箱及び I 用電離箱に用いたガスの種類、各々の電離箱の長さ、各々の電流増幅器の利得を考えずに見かけの μt の値について議論しても意味のないことである。第2、3節で吸収係数を4以下とする様に記したがそこで用いた μt はここでの μ_s ()sに相当することに注意する必要がある。見かけの $\ln(i_0/i)$ から試料の $\mu t \{ \mu_s() s \}$ を求めるためにはバックグラウンドを知っておく必要がある。

6.2 検出効率

種々のガスを用いたときの計算上の検出効率を表 6.2.1~6.2.10 に示す。ただしここに示した ガスが全て利用できるわけではない。利用できるガスについては第1部 6.2.2 節参照。表の見方 は以下の通り。

	N_2	ガスの種類
4000.	0.709	4000eVのX線に対する検出効率
	0.206	基本波と二次波の検出効率の比
	0.065	基本波と三次波の検出効率の比
	0.028	基本波と四次波の検出効率の比
X 線光子	のエネルギー(eV	単位)

先にも記したように I₀用電離箱の検出効率は 10~25%、I 用は 90%位が好ましい。I 用に高い 検出効率を得ようとして検出効率が 100%近いものを用いると、実際は信号にならない保護電極 部で吸収されてしまい、結果的には信号強度を落とすことになる。表には保護電極部を含めた光 路長に対する検出効率を記してある。

表に示す様に基本波に対する検出効率はほぼ同じでも高次波に対する検出効率はガスによって 異なるので注意を要する。図 6.2.1 に Ⅰ₀用ガスの選択例を示す。ガスを変えることによって XAFS スペクトルの形状が変化する例を図 6.2.2 に 2.5 μ m の鉄箔と 360 μ m のアルミニウム箔を重ね た試料で示す[23]。 a は I₀ に N₂を I に Ar を用いたスペクトル、 b は I₀ に N₂を I にも N₂を 用いたスペクトルである。 a では glitch が目立ち、pre-edge の形状も不良となりフーリエ変換 の結果も異常であが、 b ではかなり良好で解析に耐えるデータを得られている。この様にぎりぎ りの条件でスペクトルを測定しようとする場合はガスの選択も重要になるので普段から必要以上 に高い検出効率を求めないようにすべきである。

BL-9A の場合は光子密度が高いために、他のステーションと同じガスを用いた場合、2kV の 電位を印加しても十分に再結合を防げない場合がある。原理的には印加電圧を上げれば良いのだ が、電離箱の耐電圧や人的危険を考慮して、2kV を最高印加電圧として設定している。この点 に注意が必要である。

なお、以下の表ではX線の出入りする窓間の距離が 49mm の電離箱を SS (Short-short) 型、17cm のものを S(Short)型、31cm のものを L (Long) 型と呼んでいる。

表 6.2.1 He-N₂系ガスの検出効率(SS 型電離箱)

	N2		N2(40)+	He(60)	N2(30)+	He(70)	N2(20)+	He(80)	N2(10)+	He(90)	He	
2000	0.933		0.663		0.559		0.423		0.244		0.011	
		0.321		0.201		0.183		0.165		0.148		0.126
		0.109		0.064		0.057		0.051		0.045		0.037
		0.048		0.027		0.025		0.022		0.019		0.016
3000	0.564		0.284		0.222		0.155		0.082		0.003	
		0.180		0.149		0.144		0.139		0.134		0.126
		0.056		0.045		0.044		0.042		0.040		0.037
		0.024		0.019		0.019		0.018		0.017		0.016
4000	0.300		0.133		0.102		0.070		0.036		0.001	
		0.149		0.136		0.134		0.132		0.130		0.125
		0.045		0.041		0.040		0.040		0.039		0.037
		0.019		0.017		0.017		0.017		0.016		0.016
5000	0.168		0.071		0.054		0.037		0.019		0.001	
		0.138		0.132		0.131		0.130		0.128		0.125
		0.041		0.039		0.039		0.039		0.038		0.037
		0.018		0.017		0.017		0.016		0.016		0.016
6000	0.102		0.042		0.032		0.022		0.011		0.000	
		0.133		0.129		0.129		0.128		0.128		0.125
		0.040		0.039		0.038		0.038		0.038		0.037
		0.017		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016
7000	0.066		0.027		0.020		0.014		0.007		0.000	
		0.131		0.128		0.128		0.128		0.127		0.125
		0.039		0.038		0.038		0.038		0.038		0.037
		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016
8000	0.045		0.018		0.014		0.009		0.005		0.000	
		0.129		0.128		0.127		0.127		0.127		0.125
		0.038		0.038		0.038		0.038		0.038		0.037
		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016
9000	0.032		0.013		0.010		0.007		0.003		0.000	
		0.128		0.127		0.127		0.127		0.127		0.125
		0.038		0.038		0.038		0.038		0.038		0.037
		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016
10000	0.023		0.009		0.007		0.005		0.002		0.000	
		0.128		0.127		0.127		0.126		0.126		0.125
		0.038		0.038		0.038		0.038		0.038		0.037
		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

電極長 33mm、全ガス長 49mm

表 6.2.2 He-N₂系ガスの検出効率(S 型電離箱)

電極長 140mm、全ガス長 170mm

	N2		N2(40)+l	He(60)	N2(30)+I	He(70)	N2(20)+	He(80)	N2(10)+	He(90)	He	
2000	1.000		0.977		0.942		0.852		0.622		0.036	
		0.709		0.401		0.331		0.261		0.193		0.128
		0.311		0.142		0.113		0.085		0.061		0.038
		0.146		0.063		0.050		0.037		0.026		0.016
3000	0.944		0.686		0.582		0.443		0.258		0.011	
		0.329		0.203		0.183		0.164		0.146		0.126
		0.112		0.064		0.057		0.051		0.044		0.037
		0.049		0.027		0.024		0.022		0.019		0.016
4000	0.709		0.392		0.312		0.222		0.120		0.005	
		0.206		0.158		0.150		0.143		0.135		0.126
		0.065		0.048		0.046		0.043		0.041		0.037
		0.028		0.020		0.019		0.018		0.017		0.016
5000	0.472		0.227		0.176		0.122		0.064		0.002	
		0.166		0.142		0.138		0.135		0.131		0.125
		0.051		0.043		0.042		0.040		0.039		0.037
		0.022		0.018		0.018		0.017		0.017		0.016
6000	0.311		0.139		0.107		0.073		0.038		0.001	
		0.149		0.136		0.133		0.131		0.129		0.125
		0.045		0.041		0.040		0.039		0.039		0.037
		0.019		0.017		0.017		0.017		0.016		0.016
7000	0.210		0.090		0.069		0.047		0.024		0.001	
		0.140		0.132		0.131		0.129		0.128		0.125
		0.042		0.039		0.039		0.039		0.038		0.037
		0.018		0.017		0.017		0.016		0.016		0.016
8000	0.146		0.062		0.047		0.032		0.016		0.001	
		0.135		0.130		0.129		0.128		0.127		0.125
		0.041		0.039		0.039		0.038		0.038		0.037
		0.017		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016
9000	0.106		0.044		0.033		0.022		0.011		0.000	
		0.133		0.129		0.128		0.128		0.127		0.125
		0.040		0.038		0.038		0.038		0.038		0.037
		0.017		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016
10000	0.078		0.032		0.024		0.016		0.008		0.000	
		0.131		0.128		0.128		0.127		0.127		0.125
		0.039		0.038		0.038		0.038		0.038		0.037
		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

表 6.2.3 He-N₂系ガスの検出効率(L 型電離箱)

電極長 280mm、全ガス長 310mm

	N2		N2(40)+I	He(60)	N2(30)+I	He(70)	N2(20)+	He(80)	N2(10)+	He(90)	He	
2000	1.000		0.999		0.994		0.969		0.830		0.065	
		0.895		0.597		0.497		0.379		0.250		0.129
		0.493		0.239		0.187		0.133		0.082		0.038
		0.251		0.110		0.084		0.059		0.035		0.016
3000	0.995		0.879		0.796		0.656		0.419		0.020	
		0.495		0.272		0.233		0.196		0.162		0.126
		0.185		0.089		0.075		0.062		0.050		0.038
		0.083		0.039		0.032		0.026		0.021		0.016
4000	0.895		0.596		0.494		0.367		0.208		0.008	
		0.280		0.184		0.169		0.155		0.141		0.126
		0.092		0.057		0.052		0.047		0.043		0.037
		0.040		0.024		0.022		0.020		0.018		0.016
5000	0.688		0.374		0.297		0.211		0.113		0.004	
		0.201		0.155		0.148		0.141		0.134		0.125
		0.063		0.047		0.045		0.042		0.040		0.037
		0.027		0.020		0.019		0.018		0.017		0.016
6000	0.493		0.239		0.186		0.129		0.068		0.002	
		0.168		0.143		0.139		0.135		0.131		0.125
		0.051		0.043		0.042		0.040		0.039		0.037
		0.022		0.018		0.018		0.017		0.017		0.016
7000	0.349		0.159		0.122		0.083		0.043		0.002	
		0.152		0.137		0.134		0.132		0.129		0.125
		0.046		0.041		0.040		0.039		0.039		0.037
0000	0.051	0.020	0.110	0.017	0.004	0.017	0.057	0.017	0.000	0.016	0.001	0.016
8000	0.251	0 1 4 2	0.110	0.100	0.084	0.101	0.057	0.120	0.029	0.100	0.001	0.105
		0.143		0.133		0.131		0.130		0.128		0.125
		0.043		0.040		0.039		0.039		0.038		0.037
0000	0 104	0.018	0.070	0.017	0.000	0.017	0.040	0.016	0.021	0.016	0.001	0.016
9000	0.184	0 1 2 0	0.079	0 1 2 1	0.060	0.120	0.040	0.120	0.021	0 127	0.001	0 1 2 5
		0.138		0.131		0.130		0.129		0.127		0.125
		0.041		0.039		0.039		0.038		0.038		0.057
10000	0 1 2 9	0.018	0.059	0.017	0.044	0.010	0.020	0.010	0.015	0.010	0.001	0.016
10000	0.138	0 135	0.038	0.130	0.044	0.120	0.050	0.129	0.015	0 127	0.001	0.125
		0.133		0.130		0.129		0.128		0.127		0.123
		0.040		0.039		0.038		0.038		0.038		0.03/
		0.017		0.010		0.010		0.010		0.010		0.010

表 6.2.4 Ar-N₂系ガスの検出効率(SS 型電離箱)

電極長 33mm、全ガス長 49mm

	N2		N2(85)+.	AR(15)	N2(75)+2	AR(25)	N2(50)+	AR(50)	N2(25)+	AR(75)	AR	ł
4000	0.300		0.743		0.868		0.975		0.993		0.999	
		0.149		0.247		0.304		0.444		0.544		0.665
		0.045		0.082		0.106		0.168		0.219		0.291
		0.019		0.036		0.047		0.077		0.102		0.139
5000	0.168	0.017	0.527	0.020	0.675	0.0.7	0.873	0.077	0.94	0.102	0.981	01107
		0.138		0.192		0.222		0.298		0.36		0.449
		0.041		0.062		0.073		0.102		0.128		0.168
		0.018		0.027		0.032		0.045		0.057		0.076
6000	0.102		0.365		0.496		0.717		0.822		0.911	
		0.133		0.168		0.185		0.228		0.264		0.319
		0.04		0.053		0.059		0.075		0.088		0.11
		0.017		0.023		0.025		0.033		0.039		0.049
7000	0.066		0.256		0.36		0.562		0.676		0.795	
		0.131		0.155		0.166		0.192		0.215		0.249
		0.039		0.048		0.052		0.061		0.069		0.082
		0.016		0.021		0.022		0.027		0.03		0.036
8000	0.045		0.183		0.264		0.433		0.540		0.664	
		0.129		0.147		0.155		0.172		0.187		0.209
		0.038		0.045		0.048		0.054		0.059		0.067
		0.016		0.019		0.02		0.023		0.026		0.029
9000	0.032		0.135		0.197		0.335		0.427		0.543	
		0.128		0.142		0.148		0.16		0.170		0.185
		0.038		0.043		0.045		0.05		0.053		0.058
		0.016		0.019		0.019		0.021		0.023		0.025
10000	0.023		0.101		0.150		0.260		0.338		0.440	
		0.128		0.139		0.143		0.152		0.159		0.170
		0.038		0.042		0.044		0.047		0.049		0.053
11000	0.010	0.016	0.050	0.018	0.44.6	0.019		0.020		0.021		0.023
11000	0.018	0.107	0.078	0.107	0.116	0 1 4 0	0.205	0.147	0.270	0 1 5 0	0.357	0.1.00
		0.127		0.137		0.140		0.147		0.152		0.160
		0.038		0.041		0.042		0.045		0.047		0.049
12000	0.014	0.016	0.061	0.018	0.000	0.018	0.164	0.019	0.017	0.020	0.001	0.021
12000	0.014	0 127	0.061	0 125	0.092	0 127	0.164	0 1 4 2	0.217	0 1 4 7	0.291	0 152
		0.127		0.133		0.137		0.143		0.147		0.133
		0.038		0.041		0.042		0.043		0.043		0.047
13000	0.011	0.010	0.040	0.017	0.073	0.018	0 132	0.019	0 177	0.019	0 230	0.020
15000	0.011	0 127	0.049	0 134	0.073	0 136	0.152	0 140	0.177	0 143	0.239	0 148
		0.038		0.154		0.041		0.042		0.143		0.045
		0.000		0.017		0.017		0.042		0.019		0.049
14000	0.009	0.010	0.040	01017	0.060	01017	0.108	0.010	0.145	0.017	0.198	0.017
11000	0.000	0.126	0.0.0	0.133	0.000	0.134	0.100	0.138	01110	0.14	0.170	0.144
		0.038		0.040		0.041		0.042		0.043		0.044
		0.016		0.017		0.017		0.018		0.018		0.019
15000	0.007		0.032		0.049		0.089		0.120		0.165	
		0.126		0.132		0.133		0.136		0.138		0.141
		0.037		0.040		0.040		0.041		0.042		0.043
		0.016		0.017		0.017		0.017		0.018		0.018
16000	0.006		0.027		0.041		0.075		0.101		0.139	
		0.126		0.131		0.132		0.135		0.137		0.139
		0.037		0.039		0.040		0.041		0.041		0.042
		0.016		0.017		0.017		0.017		0.018		0.018
17000	0.005		0.023		0.034		0.063		0.085		0.118	
		0.126		0.131		0.132		0.134		0.135		0.137
		0.037		0.039		0.040		0.040		0.041		0.041
		0.016		0.017		0.017		0.017		0.017		0.018
18000	0.004		0.019		0.029		0.054		0.073		0.101	
		0.126		0.130		0.131		0.133		0.134		0.136
		0.037		0.039		0.039		0.040		0.040		0.041
		0.016		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017
19000	0.003	0.1-	0.016	0	0.025	o	0.046	· · · ·	0.062	0	0.087	0.1.5
		0.126		0.130		0.131		0.132		0.133		0.135
		0.037		0.039		0.039		0.040		0.040		0.041
20000	0.002	0.016	0.014	0.016	0.001	0.017	0.040	0.017	0.054	0.017	0.075	0.017
∠0000	0.003	0.126	0.014	0.120	0.021	0.120	0.040	0 121	0.054	0 122	0.075	0.124
		0.120		0.129		0.130		0.131		0.132		0.134
		0.057		0.059		0.039		0.039		0.040		0.04
		0.010		0.010		0.017		0.017		0.017		0.017

表 6.2.5 He-N₂系ガスの検出効率(S 型電離箱)

電極長 140mm、全ガス長 170mm

$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		N2	2	N2(85)+	Ar(15)	N2(75)+	Ar(25)	N2(50)+	Ar(50)	N2(30)+	Ar(70)	Aı	
b c c <	4000	0.709		0.991		0.999		1.000		1.000		1.000	
1 1 0.025 0.091 0.123 0.204 0.042 0.099 0.005 0.099 0.005 0.039 0.465 0.000 0.011 0.164 0.273 0.391 0.391 0.465 0.001 0.022 0.032 0.031 0.131 0.468 0.997 0.774 0.697 0.001 0.002 0.002 0.017 0.468 0.997 0.774 0.697 0.019 0.036 0.047 0.468 0.997 0.774 0.697 0.019 0.036 0.047 0.468 0.997 0.714 0.716 0.042 0.046 0.057 0.864 0.171 0.176 0.216 0.042 0.046 0.057 0.864 0.071 0.070 0.076 0.041 0.056 0.067 0.041 0.057 0.041 0.057 0.041 0.051 0.697 0.041 0.057 0.041 0.057 0.041 0.051 0.697 0.041 0.057 0.041 0.057 0.041 0.043 0.657 0.641 0.071 0.046 0.041 0.043 0.647 0.641 0.649 0.641			0.206		0.509		0.656		0.861		0.933		0.977
body 0.428 0.991 0.135 0.236 0.099 1.000 0.405 0.061 0.051 0.017 0.164 0.237 0.365 0.465 0.001 0.021 0.022 0.022 0.074 0.987 0.997 0.097 0.448 0.248 0.313 0.468 0.571 0.997 0.997 0.449 0.024 0.030 0.468 0.943 0.996 0.140 0.348 0.042 0.065 0.040 0.448 0.943 0.938 0.996 0.210 0.018 0.024 0.055 0.054 0.212 0.237 0.205 0.014 0.055 0.056 0.056 0.074 0.030 0.077 0.016 0.335 0.157 0.266 0.092 0.114 0.155 0.010 0.131 0.15 0.153 0.677 0.666 0.237 0.010 0.131 0.15 0.153 0.649 0.236			0.065		0.199		0.284		0.462		0.572		0.697
5000 0.472 0.926 0.980 0.999 1.000 1.00 0.866 0.051 0.017 0.164 0.278 0.359 0.0465 0.235 6000 0.311 0.793 0.907 0.987 0.997 1.00 0.333 6000 0.414 0.248 0.917 0.176 0.231 0.398 7000 0.210 0.042 0.082 0.038 0.980 0.980 0.990 1.00 0.019 0.641 0.348 0.981 0.913 0.977 0.965 0.018 0.028 0.035 0.661 0.933 0.977 0.966 0.017 0.024 0.026 0.237 0.331 0.414 0.456 0.017 0.022 0.025 0.649 0.741 0.931 0.309 0.007 0.313 0.155 0.168 0.224 0.332 0.330 0.330 0.016 0.020 0.022 0.023 0.032 <td< td=""><td></td><td></td><td>0.028</td><td></td><td>0.091</td><td></td><td>0.135</td><td></td><td>0.236</td><td></td><td>0.309</td><td></td><td>0.405</td></td<>			0.028		0.091		0.135		0.236		0.309		0.405
0.066 0.335 0.440 0.649 0.761 0.465 0.002 0.002 0.071 0.787 0.977 0.077 0.149 0.248 0.313 0.468 0.574 0.677 0.045 0.036 0.047 0.787 0.980 0.107 0.120 0.019 0.036 0.047 0.780 0.980 0.107 0.213 0.014 0.024 0.244 0.343 0.428 0.437 0.210 0.044 0.056 0.050 0.111 0.177 0.210 0.018 0.504 0.056 0.052 0.032 0.037 0.311 0.017 0.022 0.025 0.032 0.039 0.053 0.017 0.022 0.025 0.032 0.039 0.053 0.017 0.022 0.022 0.023 0.039 0.053 0.016 0.39 0.431 0.441 0.451 0.441 0.452 0.041 0.041 <t< td=""><td>5000</td><td>0.472</td><td></td><td>0.926</td><td></td><td>0.980</td><td></td><td>0.999</td><td></td><td>1.000</td><td></td><td>1.000</td><td></td></t<>	5000	0.472		0.926		0.980		0.999		1.000		1.000	
0.051 0.117 0.164 0.278 0.359 0.465 6000 0.311 0.793 0.907 0.987 0.997 1.000 0.045 0.022 0.107 0.176 0.231 0.308 0.019 0.045 0.028 0.107 0.176 0.231 0.308 7000 0.210 0.041 0.082 0.038 0.980 0.432 0.938 6102 0.018 0.028 0.246 0.338 0.930 0.777 0.056 8000 0.146 0.150 0.051 0.257 0.331 0.777 0.855 0.934 0.017 0.022 0.023 0.307 0.302 0.039 0.039 0.016 0.331 0.153 0.164 0.052 0.046 0.039 0.039 0.006 0.313 0.153 0.017 0.022 0.022 0.023 0.039 0.039 0.006 0.313 0.153 0.164 0.022 <			0.166		0.335		0.440		0.649		0.761		0.866
0.022 0.052 0.074 0.131 0.175 0.237 6000 0.311 0.795 0.097 0.877 0.987 0.997 0.043 0.019 0.036 0.047 0.943 0.980 0.107 0.136 7000 0.210 0.641 0.788 0.943 0.980 0.121 0.517 0.210 0.042 0.065 0.086 0.121 0.157 0.210 0.097 0.237 0.041 0.054 0.052 0.055 0.054 0.933 0.777 0.231 0.308 0.018 0.512 0.057 0.056 0.074 0.933 0.977 0.331 0.305 0.017 0.022 0.025 0.021 0.035 0.053 0.044 0.339 0.651 0.168 0.333 0.774 0.399 0.504 0.016 0.319 0.545 0.168 0.237 0.044 0.352 0.034 0.036 0.0160 0.319			0.051		0.117		0.164		0.278		0.359		0.465
			0.022		0.052		0.074		0.131		0.175		0.237
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	6000	0.311		0.793		0.907		0.987		0.997		1.000	
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $			0.149		0.248		0.313		0.468		0.574		0.697
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.045		0.082		0.107		0.176		0.231		0.308
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	7000	0.210	0.019	0 (1 1	0.036	0 799	0.047	0.042	0.080	0.000	0.107	0.000	0.146
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	7000	0.210	0 1 4 0	0.641	0.204	0.788	0.244	0.943	0 249	0.980	0 428	0.996	0 5 2 7
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.140		0.204		0.244		0.548		0.428		0.337
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.042		0.005		0.035		0.054		0.157		0.210
	8000	0 146	0.010	0 504	0.020	0.655	0.055	0.861	0.054	0.933	0.070	0 977	0.070
0.041 0.056 0.066 0.029 0.114 0.150 0.060 9000 0.106 0.037 0.024 0.028 0.040 0.050 0.050 0.050 0.040 0.051 0.183 0.230 0.249 0.330 0.049 0.330 0.041 0.015 0.055 0.052 0.032 0.039 0.049 0.031 0.007 0.017 0.020 0.021 0.052 0.064 0.074 0.091 0.241 0.039 0.048 0.052 0.064 0.074 0.262 0.022 0.022 0.023 0.041 0.245 0.016 0.019 0.221 0.025 0.026 0.032 0.041 0.246 0.057 0.065 0.057 0.065 0.067 0.065 0.067 0.065 0.057 0.065 0.067 0.065 0.067 0.065 0.067 0.065 0.067 0.065 0.067 0.066 0.076 0.076 0.076 0	0000	0.140	0.135	0.504	0.179	0.055	0.206	0.001	0.274	0.755	0.331	0.777	0.414
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.041		0.056		0.066		0.092		0.114		0.150
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.017		0.024		0.028		0.040		0.050		0.067
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9000	0.106		0.395		0.533		0.757		0.855		0.934	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.133		0.165		0.183		0.230		0.269		0.330
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.040		0.051		0.057		0.074		0.089		0.113
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.017		0.022		0.025		0.032		0.039		0.050
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10000	0.078		0.310		0.431		0.649		0.761		0.866	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.131		0.155		0.168		0.202		0.230		0.273
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.039		0.048		0.052		0.064		0.074		0.091
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.016		0.020		0.022		0.028		0.032		0.040
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	11000	0.059	0.400	0.246		0.349		0.549	0.100	0.664		0.784	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.130		0.149		0.158		0.183		0.204		0.236
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.039		0.045		0.049		0.05/		0.065		0.076
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	12000	0.046	0.016	0 107	0.019	0 284	0.021	0 462	0.025	0 572	0.028	0 607	0.033
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	12000	0.040	0 120	0.197	0 144	0.284	0.152	0.462	0 170	0.372	0.186	0.097	0.210
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.129		0.144		0.152		0.170		0.180		0.210
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.038		0.044		0.040		0.023		0.025		0.007
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	13000	0.037	0.010	0.159	0.017	0.233	0.020	0.389	0.025	0.490	0.025	0.612	0.02)
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10000	0.027	0.128	01107	0.141	0.200	0.147	0.007	0.161	01.120	0.173	01012	0.192
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.038		0.043		0.045		0.050		0.054		0.060
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.016		0.018		0.019		0.021		0.023		0.026
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	14000	0.029		0.131		0.192		0.328		0.420		0.534	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.128		0.138		0.143		0.155		0.164		0.179
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.038		0.042		0.043		0.047		0.051		0.056
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.016		0.018		0.019		0.020		0.022		0.024
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	15000	0.024		0.108		0.160		0.277		0.359		0.465	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.127		0.137		0.140		0.150		0.157		0.169
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.038		0.041		0.043		0.046		0.048		0.052
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1,000	0.020	0.016	0.000	0.018	0 125	0.018	0.226	0.020	0.200	0.021	0.405	0.022
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16000	0.020	0 127	0.090	0 125	0.135	0 129	0.230	0 146	0.309	0 152	0.405	0 162
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.127		0.133		0.138		0.140		0.152		0.102
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.036		0.041		0.042		0.044		0.047		0.021
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	17000	0.017	0.010	0.076	0.017	0.114	0.010	0.202	0.017	0.266	0.020	0.352	0.021
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1,000	0.017	0.127	0.070	0.134	0.111	0.137	0.202	0.143	0.200	0.148	0.002	0.156
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.038		0.040		0.041		0.043		0.045		0.048
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.016		0.017		0.018		0.018		0.019		0.020
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	18000	0.014		0.065		0.097		0.174		0.230		0.308	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.126		0.133		0.135		0.141		0.145		0.152
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.038		0.040		0.041		0.043		0.044		0.046
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.016		0.017		0.017		0.018		0.019		0.020
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	19000	0.012		0.056		0.084		0.150		0.200		0.269	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.126		0.132		0.134		0.139		0.142		0.148
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.038		0.040		0.040		0.042		0.043		0.045
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		0.010	0.016	0.040	0.017		0.017		0.018		0.018		0.019
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	20000	0.010	0.100	0.048	0 121	0.073	0 122	0.131	0 127	0.175	0 1 4 0	0.237	0 1 4 5
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.126		0.131		0.133		0.13/		0.140		0.145
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.03/		0.039		0.040		0.041		0.042		0.044
0.126 0.131 0.132 0.136 0.139 0.143 0.037 0.039 0.040 0.041 0.042 0.043 0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018	21000	0.009	0.010	0.042	0.017	0.063	0.017	0 114	0.018	0 153	0.010	0.209	0.019
0.037 0.039 0.040 0.041 0.042 0.043 0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018	21000	0.007	0.126	5.042	0.131	5.005	0.132	5.114	0.136	5.155	0.139	0.207	0.143
0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018			0.037		0.039		0.040		0.041		0.042		0.043
			0.016		0.017		0.017		0.017		0.018		0.018

	N2		N2(85)+.	Ar(15)	N2(75)+.	Ar(25)	N2(50)+	Ar(50)	N2(30)+	Ar(70)	Ar	
22000	0.008		0.037		0.055		0.101		0.135		0.185	
		0.126		0.130		0.132		0.135		0.137		0.141
		0.037		0.039		0.040		0.041		0.041		0.042
		0.016		0.017		0.017		0.017		0.018		0.018
23000	0.007		0.032		0.049		0.089		0.120		0.164	
		0.126		0.130		0.131		0.134		0.136		0.139
		0.037		0.039		0.039		0.040		0.041		0.042
		0.016		0.016		0.017		0.017		0.017		0.018
24000	0.006		0.028		0.043		0.079		0.106		0.146	
		0.126		0.130		0.131		0.133		0.135		0.138
		0.037		0.039		0.039		0.040		0.041		0.041
		0.016		0.016		0.017		0.017		0.017		0.018
25000	0.005		0.025		0.038		0.070		0.095		0.131	
		0.126		0.129		0.130		0.132		0.134		0.136
		0.037		0.039		0.039		0.040		0.040		0.041
		0.016		0.016		0.017		0.017		0.017		0.017
26000	0.005		0.022		0.034		0.063		0.085		0.117	
		0.126		0.129		0.130		0.132		0.133		0.135
		0.037		0.039		0.039		0.039		0.040		0.041
		0.016		0.016		0.016		0.017		0.017		0.017
27000	0.004		0.020		0.031		0.056		0.076		0.106	
		0.126		0.129		0.130		0.131		0.133		0.134
		0.037		0.038		0.039		0.039		0.040		0.040
20000	0.004	0.016	0.010	0.016	0.000	0.016	0.051	0.017	0.000	0.017	0.000	0.017
28000	0.004	0.100	0.018	0.100	0.028	0.120	0.051	0 1 2 1	0.069	0 122	0.096	0 124
		0.126		0.129		0.129		0.131		0.132		0.134
		0.037		0.038		0.039		0.039		0.040		0.040
20000	0.002	0.016	0.016	0.016	0.025	0.016	0.046	0.017	0.062	0.017	0.007	0.017
29000	0.005	0 126	0.010	0 1 2 9	0.025	0.120	0.040	0.120	0.062	0 1 2 2	0.087	0 1 2 2
		0.120		0.128		0.129		0.150		0.152		0.155
		0.037		0.038		0.039		0.039		0.039		0.040
20000	0.002	0.010	0.015	0.010	0.022	0.010	0.042	0.017	0.057	0.017	0.070	0.017
30000	0.005	0 126	0.015	0 1 2 8	0.025	0.120	0.042	0.120	0.037	0 121	0.079	0 1 2 2
		0.120		0.128		0.129		0.130		0.131		0.132
		0.03/		0.038		0.038		0.039		0.039		0.040
		0.010		0.010		0.010		0.010		0.017		0.017

表 6.2.6 Ar-N₂系ガスの検出効率(L 型電離箱)

電極長 280mm、全ガス長 310mm

	N2		N2(85)+.	Ar(15)	N2(75)+	Ar(25)	N2(50)+	+Ar(50)	N2(30)+	Ar(70)	Aı	•
4000	0.895		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
		0.280		0.722		0.856		0.973		0.993		0.999
		0.092		0.330		0.456		0.677		0.788		0.886
		0.040		0.159		0.232		0.388		0.490		0.612
5000	0.688		0.991	0.404	0.999	0.440	1.000		1.000		1.000	0.054
		0.201		0.496		0.643		0.852		0.927		0.974
		0.063		0.190		0.273		0.447		0.556		0.680
6000	0.402	0.027	0.042	0.087	0.087	0.128	1 000	0.226	1 000	0.296	1 000	0.389
0000	0.495	0 168	0.945	0 3/0	0.987	0.462	1.000	0.678	1.000	0 788	1.000	0.886
		0.108		0.349		0.402		0.078		0.788		0.000
		0.031		0.122		0.173		0.139		0.379		0.489
7000	0 349	0.022	0.845	0.054	0.941	0.070	0 995	0.157	0 999	0.105	1 000	0.231
1000	0.517	0.152	0.015	0.267	0.711	0.343	0.775	0.518	0.777	0.630	1.000	0.752
		0.046		0.089		0.119		0.200		0.262		0.348
		0.020		0.039		0.053		0.091		0.122		0.167
8000	0.251		0.722		0.856		0.973		0.993		0.999	
		0.143		0.220		0.271		0.399		0.493		0.612
		0.043		0.071		0.090		0.143		0.187		0.251
		0.018		0.031		0.039		0.064		0.085		0.116
9000	0.184		0.600		0.751		0.924		0.971		0.993	
		0.138		0.192		0.227		0.318		0.391		0.492
		0.041		0.061		0.073		0.109		0.139		0.186
10000	0.400	0.018	0.400	0.026	0.440	0.032	0.050	0.048		0.062	0.054	0.084
10000	0.138	0 1 2 5	0.492	0 175	0.643	0.000	0.852	0.045	0.927	0.010	0.974	0.000
		0.135		0.175		0.200		0.265		0.319		0.399
		0.040		0.054		0.063		0.088		0.109		0.142
11000	0.106	0.017	0.402	0.023	0 5 4 2	0.027	0 766	0.038	0.862	0.048	0.020	0.065
11000	0.100	0 122	0.402	0 162	0.345	0 1 8 2	0.700	0 220	0.805	0.270	0.939	0 221
		0.132		0.103		0.162		0.229		0.270		0.331
		0.040		0.022		0.037		0.032		0.009		0.050
12000	0.083	0.017	0.329	0.022	0.456	0.024	0.677	0.052	0.788	0.057	0.886	0.050
12000	0.000	0.131	0.02)	0.155	01100	0.169	0.077	0.205	01700	0.236	0.000	0.283
		0.039		0.048		0.052		0.065		0.076		0.094
		0.016		0.020		0.022		0.028		0.033		0.041
13000	0.066		0.272		0.383		0.592		0.708		0.822	
		0.130		0.150		0.160		0.188		0.211		0.248
		0.039		0.046		0.049		0.059		0.067		0.081
		0.016		0.019		0.021		0.025		0.029		0.035
14000	0.053		0.225		0.322		0.515		0.629		0.752	
		0.129		0.145		0.154		0.176		0.194		0.223
		0.038		0.044		0.047		0.055		0.061		0.071
15000	0.042	0.016	0 100	0.019	0.072	0.020	0 4 4 7	0.023	0.556	0.026	0.000	0.031
15000	0.043	0 1 2 9	0.188	0 1 4 2	0.273	0 140	0.447	0 167	0.550	0 1 9 1	0.680	0.204
		0.128		0.142		0.149		0.107		0.181		0.204
		0.038		0.043		0.045		0.031		0.037		0.005
16000	0.036	0.010	0.159	0.010	0.232	0.017	0.388	0.022	0.490	0.024	0.612	0.020
10000	0.050	0.128	0.157	0.140	0.252	0.145	0.500	0.160	0.170	0.172	0.012	0.190
		0.038		0.042		0.044		0.049		0.053		0.060
		0.016		0.018		0.019		0.021		0.023		0.026
17000	0.030		0.135		0.198		0.337		0.431		0.547	
		0.127		0.138		0.143		0.154		0.164		0.179
		0.038		0.042		0.043		0.047		0.051		0.056
		0.016		0.018		0.018		0.020		0.022		0.024
18000	0.025		0.115		0.171		0.294		0.379		0.489	
		0.127		0.136		0.140		0.150		0.158		0.171
		0.038		0.041		0.042		0.046		0.048		0.053
10000		0.016	0.000	0.017	o .	0.018		0.019		0.021	0.49.6	0.023
19000	0.022	0 107	0.099	0 125	0.147	0 1 2 0	0.257	0 1 4 7	0.335	0.154	0.436	0.164
		0.127		0.135		0.138		0.147		0.154		0.164
		0.038		0.041		0.042		0.045		0.04/		0.050
20000	0.010	0.010	0.096	0.017	0 1 2 9	0.018	0.226	0.019	0 206	0.020	0 3 8 0	0.022
20000	0.019	0 1 2 7	0.080	0.134	0.128	0 137	0.220	0.144	0.290	0.150	0.389	0 1 5 0
		0.038		0.134		0.041		0.044		0.150		0.139
		0.016		0.017		0.017		0.019		0.019		0.021
21000	0.016	0.010	0.075	5.01/	0.112	5.017	0.199	5.017	0.262	0.017	0.348	5.021
		0.126		0.133		0.136		0.142		0.147		0.154
		0.038		0.040		0.041		0.043		0.045		0.047
		0.016		0.017		0.017		0.018		0.019		0.020

	N2		N2(85)+.	Ar(15)	N2(75)+.	Ar(25)	N2(50)+	Ar(50)	N2(30)+	Ar(70)	Ar	
22000	0.014		0.066		0.099		0.176		0.233		0.311	
		0.126		0.132		0.134		0.140		0.144		0.151
		0.038		0.040		0.040		0.042		0.044		0.046
		0.016		0.017		0.017		0.018		0.019		0.020
23000	0.012		0.058		0.087		0.156		0.207		0.279	
		0.126		0.132		0.134		0.138		0.142		0.148
		0.037		0.039		0.040		0.042		0.043		0.045
		0.016		0.017		0.017		0.018		0.018		0.019
24000	0.011		0.051		0.077		0.139		0.185		0.251	
		0.126		0.131		0.133		0.137		0.140		0.145
		0.037		0.039		0.040		0.041		0.042		0.044
		0.016		0.017		0.017		0.017		0.018		0.019
25000	0.010		0.045		0.069		0.124		0.166		0.226	
		0.126		0.131		0.132		0.136		0.139		0.143
		0.037		0.039		0.040		0.041		0.042		0.043
		0.016		0.017		0.017		0.017		0.018		0.018
26000	0.009		0.041		0.061		0.111		0.150		0.204	
		0.126		0.130		0.132		0.135		0.137		0.141
		0.037		0.039		0.039		0.041		0.041		0.043
27000	0.000	0.016	0.000	0.016	0.055	0.017	0 1 0 0	0.017	0.105	0.018	0.104	0.018
27000	0.008	0.106	0.036	0.120	0.055	0.101	0.100	0.104	0.135	0.106	0.184	0 1 4 0
		0.126		0.130		0.131		0.134		0.136		0.140
		0.037		0.039		0.039		0.040		0.041		0.042
28000	0.007	0.016	0.022	0.016	0.050	0.017	0.001	0.017	0 122	0.017	0.167	0.018
28000	0.007	0.126	0.033	0.120	0.050	0 1 2 1	0.091	0 1 2 2	0.122	0 125	0.10/	0 1 2 0
		0.120		0.129		0.151		0.155		0.155		0.158
		0.057		0.039		0.039		0.040		0.041		0.042
20000	0.006	0.010	0.030	0.010	0.045	0.017	0.082	0.017	0 111	0.017	0.152	0.018
29000	0.000	0.126	0.050	0.120	0.045	0.130	0.082	0 133	0.111	0.135	0.152	0 137
		0.120		0.129		0.130		0.135		0.135		0.137
		0.037		0.037		0.037		0.040		0.040		0.041
30000	0.006	0.010	0.027	0.010	0.041	0.010	0.075	0.017	0.101	0.017	0 1 3 9	0.010
30000	0.000	0.126	0.027	0 1 2 9	0.041	0.130	0.075	0 132	0.101	0 134	0.159	0 1 3 6
		0.037		0.038		0.039		0.040		0.040		0.041
		0.016		0.016		0.016		0.017		0.017		0.017
		5.010		0.010		0.010		0.017		0.017		5.017

表 6.2.7 Ar-N₂系ガスの検出効率(L型電離箱 二連)

(電極長 280mm、全ガス長 310mm)× 2

	N2		N2(85)+	Ar(15)	N2(75)+	Ar(25)	N2(50)+	Ar(50)	N2(25)+	Ar(75)	Ar	•
4000	0.989		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
		0.444		0.923		0.979		0.999		1.000		1.000
		0.160		0.550		0.704		0.896		0.955		0.987
5000	0.002	0.071	1 000	0.292	1 000	0.410	1 000	0.626	1 000	0.740	1 000	0.849
5000	0.903	0.285	1.000	0 742	1.000	0 872	1.000	0.078	1.000	0.005	1.000	0.000
		0.285		0.742		0.872		0.978		0.993		0.999
		0.094		0.164		0.471		0.094		0.803		0.627
6000	0.743	0.041	0.997	0.104	1.000	0.240	1.000	0.400	1.000	0.504	1.000	0.027
		0.213		0.552		0.704		0.896		0.955		0.987
		0.067		0.218		0.312		0.502		0.615		0.739
		0.029		0.100		0.148		0.259		0.337		0.438
7000	0.576		0.976		0.996		1.000		1.000		1.000	
		0.179		0.410		0.543		0.765		0.862		0.938
		0.055		0.148		0.212		0.358		0.455		0.574
		0.024		0.066		0.097		0.173		0.229		0.307
8000	0.439		0.923		0.979	0.440	0.999		1.000		1.000	0.040
		0.161		0.317		0.419		0.626		0.740		0.849
		0.049		0.108		0.151		0.259		0.337		0.438
0000	0.224	0.021	0.840	0.048	0.028	0.068	0.004	0.120	0.000	0.161	1 000	0.219
9000	0.334	0.150	0.840	0.250	0.938	0 333	0.994	0 505	0.999	0.615	1.000	0 730
		0.150		0.239		0.333		0.303		0.013		0.739
		0.045		0.037		0.050		0.192		0.232		0.335
10000	0.257	0.017	0.742	0.037	0.872	0.050	0.978	0.007	0.995	0.117	0.999	0.100
10000	0.207	0.143	0.7 12	0.222	0.072	0.275	0.770	0.409	0.775	0.507	0.777	0.627
		0.043		0.071		0.091		0.147		0.192		0.258
		0.018		0.031		0.040		0.065		0.087		0.120
11000	0.200		0.642		0.791		0.945		0.981		0.996	
		0.139		0.198		0.237		0.339		0.419		0.527
		0.042		0.062		0.077		0.117		0.151		0.203
		0.018		0.027		0.033		0.051		0.067		0.092
12000	0.158		0.550		0.704		0.896		0.955		0.987	
		0.136		0.181		0.211		0.289		0.352		0.444
		0.041		0.057		0.067		0.096		0.122		0.162
12000	0 107	0.017	0.460	0.024	0 (10	0.029	0.024	0.042	0.014	0.054	0.070	0.072
13000	0.127	0 124	0.469	0 170	0.619	0 102	0.834	0.252	0.914	0 202	0.968	0 270
		0.134		0.170		0.192		0.232		0.303		0.578
		0.040		0.032		0.000		0.082		0.102		0.155
14000	0.103	0.017	0.400	0.022	0.541	0.020	0 765	0.050	0.862	0.045	0.938	0.039
14000	0.105	0.132	0.400	0.161	0.541	0.179	0.705	0.226	0.002	0.266	0.750	0.327
		0.039		0.050		0.056		0.073		0.087		0.111
		0.017		0.021		0.024		0.031		0.038		0.049
15000	0.085		0.341		0.471		0.694		0.803		0.898	
		0.131		0.155		0.169		0.207		0.238		0.288
		0.039		0.047		0.052		0.066		0.077		0.096
		0.016		0.020		0.022		0.028		0.033		0.042
16000	0.070		0.292		0.410		0.626		0.740		0.849	
		0.130		0.150		0.162		0.192		0.218		0.258
		0.039		0.046		0.050		0.060		0.069		0.084
17000	0.050	0.016	0.251	0.019	0 257	0.021	0.561	0.026	0 676	0.030	0.705	0.03/
17000	0.039	0 1 2 0	0.231	0 146	0.557	0 156	0.301	0 181	0.070	0 202	0.795	0.234
		0.129		0.140		0.130		0.181		0.202		0.234
		0.038		0.044		0.040		0.024		0.004		0.070
18000	0.050	0.010	0.217	0.017	0.312	0.020	0.502	0.02.	0.615	0.027	0.739	0.000
		0.129		0.143		0.151		0.172		0.189		0.216
		0.038		0.043		0.046		0.053		0.059		0.069
		0.016		0.018		0.020		0.023		0.025		0.030
19000	0.043		0.189		0.273		0.448		0.557		0.682	
		0.128		0.141		0.148		0.165		0.180		0.202
		0.038		0.043		0.045		0.051		0.056		0.064
		0.016		0.018		0.019		0.022		0.024		0.027
20000	0.037		0.164		0.240		0.400		0.504		0.627	
		0.128		0.139		0.145		0.160		0.172		0.191
		0.038		0.042		0.044		0.049		0.053		0.060
21000	0.022	0.016	0 1 4 4	0.018	0.212	0.019	0.250	0.021	0 455	0.023	0 574	0.026
21000	0.052	0 1 2 7	0.144	0 127	0.212	0.142	0.338	0 155	0.433	0 166	0.374	0 1 9 2
		0.038		0.041		0.043		0.047		0.051		0.057
		0.016		0.018		0.018		0.020		0.022		0.024
								5.520				<i>u</i> r

	N2		N2(85)+2	Ar(15)	N2(75)+	Ar(25)	N2(50)+.	Ar(50)	N2(25)+	Ar(75)	Ar	
22000	0.028		0.127		0.187		0.321		0.411		0.525	
		0.127		0.136		0.140		0.151		0.160		0.174
		0.038		0.041		0.042		0.046		0.049		0.054
		0.016		0.017		0.018		0.020		0.021		0.023
23000	0.024		0.112		0.166		0.288		0.372		0.480	
		0.127		0.135		0.139		0.148		0.156		0.168
		0.038		0.041		0.042		0.045		0.048		0.052
		0.016		0.017		0.018		0.019		0.020		0.022
24000	0.022		0.100		0.148		0.259		0.337		0.438	
		0.127		0.134		0.137		0.146		0.153		0.163
		0.038		0.040		0.041		0.044		0.046		0.050
		0.016		0.017		0.018		0.019		0.020		0.021
25000	0.019		0.089		0.133		0.233		0.305		0.400	
		0.127		0.133		0.136		0.144		0.150		0.159
		0.038		0.040		0.041		0.043		0.045		0.049
		0.016		0.017		0.017		0.018		0.019		0.021
26000	0.017		0.080		0.119		0.211		0.277		0.366	
		0.126		0.132		0.135		0.142		0.147		0.155
		0.038		0.040		0.041		0.043		0.045		0.047
		0.016		0.017		0.017		0.018		0.019		0.020
27000	0.015		0.071		0.107		0.191		0.252		0.335	
		0.126		0.132		0.134		0.140		0.145		0.152
		0.037		0.039		0.040		0.042		0.044		0.046
		0.016		0.017		0.017		0.018		0.019		0.020
28000	0.014		0.064		0.097		0.173	0.100	0.229		0.307	0.4.40
		0.126		0.131		0.134		0.139		0.143		0.149
		0.037		0.039		0.040		0.042		0.043		0.045
	0.010	0.016	0.050	0.017	0.000	0.017		0.018		0.018	0.001	0.019
29000	0.012	0.100	0.058	0 101	0.088	0.100	0.157	0.100	0.209	0 1 1 1	0.281	0.1.47
		0.126		0.131		0.133		0.138		0.141		0.147
		0.037		0.039		0.040		0.041		0.043		0.045
20000	0.011	0.016	0.052	0.017	0.000	0.017	0 1 4 4	0.018	0 101	0.018	0.050	0.019
30000	0.011	0.126	0.053	0.120	0.080	0 1 2 2	0.144	0 127	0.191	0.140	0.258	0 1 4 5
		0.120		0.150		0.152		0.15/		0.140		0.145
		0.03/		0.039		0.040		0.041		0.042		0.044
		0.010		0.017		0.017		0.017		0.018		0.019

表 6.2.8 Kr-N₂系ガスの検出効率(L 型電離箱)

電極長 280mm、全ガス長 310mm

		N2		N2(85)+	Kr(15)	N2(75)+	Kr(25)	N2(50)+	Kr(50)	N2(25)+	Kr(75)	Kr	
0.128 0.332 0.451 0.684 0.807 0.401 0.519 16000 0.036 0.173 0.307 0.401 0.201 0.211 16000 0.036 0.104 0.402 0.619 0.337 0.401 0.036 0.104 0.404 0.263 0.347 0.455 0.036 0.798 0.995 0.995 0.995 0.995 0.030 0.798 0.202 0.915 0.391 0.301 0.400 0.035 0.044 0.390 0.599 0.301 0.400 0.400 0.035 0.042 0.898 0.898 0.196 0.311 0.100 18000 0.025 0.748 0.392 0.091 0.101 0.222 0.301 19000 0.022 0.637 0.235 0.299 0.456 0.564 0.649 0.038 0.073 0.041 0.591 0.222 0.309 19000 0.122 0.639 <	15000	0.043		0.887		0.973		0.999		1.000		1.000	
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $			0.128		0.332		0.451		0.684		0.800		0.899
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $			0.038		0.118		0.173		0.307		0.401		0.519
16000 0.036 0.844 0.954 0.098 0.100 0.739 0.835 17000 0.038 0.014 0.149 0.263 0.347 0.453 17000 0.036 0.078 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.802 17000 0.027 0.038 0.094 0.130 0.227 0.301 0.401 0.016 0.042 0.038 0.051 0.998 0.604 0.748 0.025 0.748 0.898 0.899 0.504 0.602 0.739 0.016 0.038 0.011 0.991 0.123 0.017 0.016 0.038 0.073 0.173 0.222 0.399 0.016 0.050 0.224 0.966 0.992 0.991 0.016 0.050 0.224 0.968 0.917 0.224 0.273 0.016 0.050 0.224 0.968 0.921 0.127 0.217			0.016		0.053		0.079		0.148		0.200		0.273
0.128 0.300 0.402 0.619 0.739 0.337 0.435 17000 0.016 0.047 0.068 0.124 0.169 0.337 0.435 17000 0.016 0.274 0.360 0.559 0.679 0.301 0.440 0.016 0.042 0.088 0.027 0.301 0.440 0.490 18000 0.025 0.748 0.898 0.989 0.998 1.000 19000 0.016 0.038 0.051 0.991 0.123 0.171 19000 0.022 0.999 0.456 0.996 1.000 0.133 0.173 0.229 0.395 19000 0.127 0.650 0.229 0.456 0.996 0.999 0.191 0.141 20000 0.117 0.622 0.391 0.141 0.262 0.273 0.995 0.133 0.123 0.123 0.141 0.262 0.273 0.395 0.123 0.124 0.261 0.299 <td>16000</td> <td>0.036</td> <td></td> <td>0.844</td> <td></td> <td>0.954</td> <td></td> <td>0.998</td> <td></td> <td>1.000</td> <td></td> <td>1.000</td> <td></td>	16000	0.036		0.844		0.954		0.998		1.000		1.000	
17000 0.038 0.104 0.149 0.263 0.149 0.232 17000 0.030 0.798 0.792 0.668 0.995 0.999 1.000 0.127 0.237 0.301 0.401 0.127 0.301 0.401 0.038 0.094 0.130 0.227 0.301 0.401 0.016 0.0425 0.748 0.898 0.998 0.998 1.000 0.130 0.036 0.035 0.115 0.197 0.262 0.311 0.016 0.032 0.699 0.863 0.981 0.996 1.000 0.130 0.038 0.078 0.031 0.171 0.229 0.399 0.010 0.038 0.073 0.946 0.979 0.107 0.104 0.016 0.032 0.041 0.155 0.202 0.273 0.016 0.033 0.073 0.946 0.130 0.124 0.016 0.032 0.041 0.151			0.128		0.300		0.402		0.619		0.739		0.853
17000 0.016 0.078 0.929 0.995 0.999 1.000 17000 0.167 0.774 0.360 0.559 0.679 0.800 0.016 0.042 0.388 0.995 0.998 1006 0.414 0.197 18000 0.227 0.748 0.898 0.999 0.167 0.262 0.748 0.016 0.038 0.085 0.115 0.197 0.262 0.738 0.016 0.038 0.078 0.091 0.123 0.171 19000 0.022 0.699 0.863 0.991 0.160 0.391 0.016 0.034 0.046 0.079 0.107 0.134 0.016 0.032 0.941 0.999 0.129 0.101 0.032 0.941 0.946 0.992 0.999 1100 0.112 0.220 0.768 0.414 0.998 0.129 1100 0.121 0.57 0.740 0.232 0			0.038		0.104		0.149		0.263		0.347		0.455
17000 0.030 0.788 0.992 0.995 0.999 1.000 0.127 0.747 0.360 0.559 0.679 0.802 0.033 0.094 0.130 0.227 0.301 0.400 0.016 0.042 0.888 0.058 0.106 0.141 0.199 18000 0.025 0.748 0.889 0.899 0.998 1.000 0.127 0.253 0.326 0.504 0.620 0.374 0.016 0.038 0.051 0.091 0.123 0.171 0.900 0.016 0.034 0.046 0.079 0.229 0.363 0.016 0.034 0.046 0.079 0.212 0.276 0.414 0.016 0.032 0.273 0.276 0.414 0.516 0.999 1000 0.161 0.326 0.273 0.273 0.291 0.282 0.016 0.328 0.664 0.681 0.163 0.171 <t< td=""><td></td><td></td><td>0.016</td><td></td><td>0.047</td><td></td><td>0.068</td><td></td><td>0.124</td><td></td><td>0.169</td><td></td><td>0.232</td></t<>			0.016		0.047		0.068		0.124		0.169		0.232
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	17000	0.030		0.798		0.929		0.995		0.999		1.000	
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $			0.127		0.274		0.360		0.559		0.679		0.802
			0.038		0.094		0.130		0.227		0.301		0.400
			0.016		0.042		0.058		0.106		0.144		0.199
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	18000	0.025		0.748		0.898		0.989		0.998		1.000	
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $			0.127		0.253		0.326		0.504		0.620		0.748
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $			0.038		0.085		0.115		0.197		0.262		0.351
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.016		0.038		0.051		0.091		0.123		0.171
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	19000	0.022	0.107	0.699	0 005	0.863	0.000	0.981	0.456	0.996	0.544	1.000	0 60 4
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.127		0.235		0.299		0.456		0.566		0.694
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.038		0.078		0.103		0.173		0.229		0.309
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	20000	0.010	0.016	0 (50	0.034	0.924	0.046	0.079	0.079	0.002	0.107	0.000	0.148
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	20000	0.019	0 127	0.650	0 222	0.824	0 276	0.968	0.414	0.992	0.516	0.999	0.641
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.127		0.222		0.270		0.414		0.510		0.041
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.038		0.075		0.094		0.155		0.202		0.275
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	21000	0.016	0.010	0.602	0.032	0 783	0.041	0.052	0.009	0.086	0.093	0 008	0.129
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	21000	0.010	0.126	0.002	0.210	0.785	0.256	0.952	0 378	0.980	0.471	0.998	0 591
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.038		0.210		0.230		0.376		0.471		0.371
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.036		0.000		0.038		0.150		0.082		0.113
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	22000	0.014	0.010	0 557	0.050	0 740	0.050	0.932	0.001	0 976	0.002	0 995	0.115
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	22000	0.011	0.126	0.557	0.200	0.7 10	0.241	0.752	0.347	0.770	0.431	0.775	0.544
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.038		0.065		0.080		0.122		0.160		0.216
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.016		0.028		0.035		0.055		0.072		0.100
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	23000	0.012		0.515		0.698		0.908		0.964		0.991	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.126		0.192		0.227		0.321		0.396		0.501
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.037		0.062		0.075		0.111		0.143		0.193
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.016		0.027		0.033		0.049		0.064		0.088
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	24000	0.011		0.475		0.656		0.880		0.949		0.986	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.126		0.186		0.216		0.298		0.365		0.462
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.037		0.059		0.070		0.102		0.130		0.174
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.016		0.026		0.031		0.045		0.058		0.079
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	25000	0.010		0.438		0.615		0.851		0.930		0.977	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.126		0.180		0.207		0.279		0.339		0.427
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.037		0.057		0.067		0.094		0.118		0.157
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.016		0.025		0.029		0.041		0.053		0.071
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	26000	0.009		0.404		0.576		0.819		0.908		0.967	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.126		0.175		0.198		0.262		0.316		0.396
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.037		0.055		0.064		0.088		0.109		0.143
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	27000	0.000	0.016	0.070	0.024	0.520	0.028	0.704	0.038	0.004	0.048	0.054	0.064
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	27000	0.008	0.100	0.3/3	0 170	0.539	0.100	0.786	0.040	0.884	0.000	0.954	0.260
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.126		0.170		0.192		0.248		0.296		0.368
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.037		0.054		0.001		0.082		0.101		0.151
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	28000	0.007	0.016	0.245	0.023	0 502	0.026	0 752	0.030	0 957	0.044	0.029	0.058
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	20000	0.007	0 126	0.343	0 167	0.303	0 1 9 5	0.752	0 226	0.857	0 270	0.938	0 344
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.120		0.107		0.165		0.230		0.279		0.344
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.037		0.032		0.039		0.077		0.094		0.120
0.126 0.163 0.180 0.225 0.264 0.323 0.037 0.051 0.057 0.073 0.088 0.111 0.016 0.022 0.025 0.032 0.038 0.111 30000 0.006 0.295 0.439 0.684 0.800 0.899 0.126 0.160 0.176 0.216 0.250 0.304 0.037 0.050 0.055 0.070 0.083 0.103 0.016 0.021 0.024 0.030 0.036 0.046	29000	0.006	0.010	0 319	0.023	0.470	0.023	0 718	0.054	0 829	0.041	0.920	0.055
30000 0.006 0.125 0.105 0.105 0.125 0.126 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.126 0.111 0.016 0.012 0.025 0.032 0.038 0.111 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.016 0.025 0.304 0.026 0.304 0.049 0.049 0.016 0.025 0.016 0.025 0.016 0.026 0.036 0.026 0.036 0.046 0.016 0.021 0.024 0.030 0.036 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.0	27000	0.000	0.126	0.517	0 163	0.470	0.180	0.710	0 225	0.02)	0 264	0.720	0 323
30000 0.006 0.021 0.025 0.032 0.036 0.049 30000 0.006 0.295 0.439 0.684 0.800 0.899 0.126 0.160 0.176 0.216 0.250 0.304 0.037 0.050 0.055 0.070 0.083 0.103 0.016 0.021 0.024 0.030 0.036 0.046			0.037		0.051		0.057		0.073		0.088		0.111
30000 0.006 0.295 0.439 0.684 0.800 0.899 0.126 0.160 0.176 0.216 0.250 0.304 0.037 0.050 0.055 0.070 0.083 0.103 0.016 0.021 0.024 0.030 0.036 0.046			0.016		0.022		0.025		0.032		0.038		0.049
0.126 0.160 0.176 0.216 0.250 0.304 0.037 0.050 0.055 0.070 0.083 0.103 0.016 0.021 0.024 0.030 0.036 0.046	30000	0.006	0.010	0.295	0.022	0.439	0.020	0.684	0.002	0.800	0.000	0.899	5.517
0.037 0.050 0.055 0.070 0.083 0.103 0.016 0.021 0.024 0.030 0.036 0.046	2.000		0.126		0.160		0.176	2.001	0.216	2.000	0.250		0.304
0.016 0.021 0.024 0.030 0.036 0.046			0.037		0.050		0.055		0.070		0.083		0.103
			0.016		0.021		0.024		0.030		0.036		0.046

表 6.2.9 蛍光 XAFS 用電離箱 (EXAFS Co.,

Ltd. 製)

全ガス長 30mm

$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		Ar		Kı	ſ	Xe	2
0.494 0.707 0.996 0.192 0.318 0.693 0.651 5000 0.712 0.328 0.482 0.955 0.115 0.757 0.647 0.372 6000 0.772 0.937 1.000 0.852 0.001 0.623 0.647 0.372 6000 0.772 0.937 1.000 0.852 0.003 0.260 0.373 0.465 0.038 0.623 0.463 0.455 0.002 0.280 0.283 0.163 0.028 0.283 0.699 0.163 0.020 0.281 0.284 0.283 0.002 0.246 0.240 0.114 0.002 0.241 0.240 0.141 0.002 0.214 0.980 0.412 0.002 0.214 0.418 0.142 0.004 0.418 0.142 0.300 0.145 1.059 0.284 0.341	4000	0.987		1.000		1.000	
0.192 0.318 0.852 5000 0.911 0.990 1.000 0.328 0.482 0.955 0.115 0.757 0.647 0.020 0.492 0.372 6000 0.772 0.937 1.000 0.246 0.339 0.452 0.081 0.623 0.623 0.036 0.339 0.242 7000 0.621 0.833 0.999 0.0203 0.260 0.716 0.024 0.243 0.163 0.024 0.240 0.414 0.024 0.240 0.414 0.024 0.240 0.414 0.024 0.240 0.414 0.024 0.240 0.414 0.024 0.240 0.414 0.024 0.241 0.474 0.024 0.241 0.429 0.145 1.021 0.390 0.441 0.412 0.412 0.040 <			0.494		0.707		0.996
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.192		0.318		0.852
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.089		0.693		0.581
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5000	0.911		0.990		1.000	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.328		0.482		0.955
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.115		0.757		0.647
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.051		0.492		0.372
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	6000	0.772		0.937		1.000	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.246		0.339		0.852
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.081		0.623		0.465
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	7000	0 (21	0.036	0 022	0.359	0.000	0.242
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	/000	0.621	0.202	0.833	0 260	0.999	0.716
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.203		0.200		0.710
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.003		0.332		0.555
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8000	0 487	0.020	0 707	0.205	0 996	0.105
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0000	0.107	0.180	0.707	0.980	0.770	0.584
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.057		0.476		0.243
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.024		0.240		0.114
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9000	0.381		0.584		0.983	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.165		1.000		0.474
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.051		0.441		0.182
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.022		0.214		0.429
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10000	0.299		0.477		0.955	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.156		1.021		0.390
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.048		0.418		0.142
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	11000	0.007	0.021	0.000	0.198	0.010	0.360
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	11000	0.237	0 1 4 0	0.388	1.041	0.910	0.220
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.149		1.041		0.328
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.040		0.405		0.115
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	12000	0 190	0.020	0.318	0.187	0.852	0.308
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	12000	0.170	0.145	0.510	1.059	0.052	0.284
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.044		0.393		0.494
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.019		0.180		0.271
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	13000	0.154		0.261		0.786	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.142		1.075		0.251
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.043		0.386		0.460
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.018		0.175		0.243
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	14000	0.126		0.217		0.716	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.139		1.089		0.227
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.042		0.381		0.433
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	15000	0.105	0.018	0.740	0.171	0 (17	0.223
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	13000	0.105	0 127	0.749	0 266	0.047	0.200
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.137		0.200		0.209
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.018		0.041		0.207
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16000	0.087	0.010	0.693	0.011	0.581	0.207
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.136		0.245		0.196
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.041		0.082		0.397
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.017		0.036		0.196
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	17000	0.074		0.637		0.521	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.135		0.228		0.185
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.041		0.076		0.385
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.017		0.033		0.186
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	18000	0.063		0.584		0.465	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.134		0.214		0.905
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.040		0.070		0.375
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10000	0.051	0.017	0.500	0.031	0.11-	0.179
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	19000	0.054	0 1 2 2	0.533	0 202	0.416	0.014
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.133		0.203		0.914
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.040		0.000		0.30/
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	20000	0.047	0.017	0 4 8 7	0.029	0 372	0.175
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	20000	0.047	0.132	0.407	0.194	0.572	0.923
0.017 0.027 0.169			0.040		0.062		0.361
0.102/ 0.109			0.017		0.027		0.169

	Aı	ſ	Kı	r	Xe	e
21000	0.040		0.444		0.333	
		0.131		0.186		0.931
		0.039		0.060		0.355
		0.017		0.026		0.165
22000	0.035		0.404		0.299	
		0.131		0.180		0.940
		0.039		0.057		0.351
		0.017		0.025		0.162
23000	0.031		0.369		0.268	
		0.131		0.174		0.947
		0.039		0.055		0.348
		0.017		0.024		0.159
24000	0.028		0.336		0.242	
		0.130		0.170		0.954
		0.039		0.054		0.345
		0.017		0.023		0.157
25000	0.024		0.307		0.218	
		0.130		0.166		0.961
		0.039		0.052		0.343
		0.016		0.022		0.155
26000	0.022		0.281		0.197	
		0.130		0.162		0.968
		0.039		0.051		0.341
		0.016		0.022		0.154
27000	0.020		0.257		0.179	
		0.129		0.159		0.974
		0.039		0.050		0.339
		0.016		0.021		0.152
28000	0.018		0.236		0.163	
		0.129		0.157		0.979
		0.039		0.049		0.337
		0.016		0.021		0.151
29000	0.016	0.100	0.217		0.148	0 00 -
		0.129		0.155		0.985
		0.038		0.048		0.336
	0.01.1	0.016	0.400	0.021		0.150
30000	0.014	0.100	0.199	0.455	0.135	0.000
		0.129		0.153		0.990
		0.038		0.047		0.335
		0.016		0.020		0.149

表 6.2.10 蛍光 XAFS 用電離箱 (PF 製)

全ガス長 100mm

$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		Aı	•	Kı	r	Xe	e
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	4000	1.000		1.000		1.000	
5000 1.000 1.000 1.000 0.998 5000 1.000 1.000 1.000 0.998 6000 0.993 1.000 1.000 0.998 6000 0.993 1.000 1.000 0.998 7000 0.960 0.745 0.603 7000 0.960 0.377 0.558 0.997 0.134 0.860 0.741 0.603 0.000 0.578 0.603 0.447 8000 0.892 0.997 1.000 0.100 0.758 0.603 0.044 0.469 0.001 0.058 0.997 0.945 0.004 0.469 0.001 0.010 0.758 0.603 0.029 0.997 0.945 0.029 0.318 1.000 0.212 1.008 0.754 0.029 0.318 0.754 0.020 0.212 0.044 0.212 0.046			0.892		0.983		1.000
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.504		0.720		0.998
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.263		0.980		0.945
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5000	1.000		1.000		1.000	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.694		0.884		1.000
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.308		0.990		0.969
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.147		0.892		0.788
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	6000	0.993		1.000		1.000	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.508		0.720		0.998
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.196		0.946		0.876
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.089		0.745		0.603
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	7000	0.960	0.277	0.997	0.550	1.000	0.005
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.377		0.558		0.985
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.134		0.860		0.741
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8000	0.802	0.000	0.083	0.394	1 000	0.447
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8000	0.692	0.205	0.985	0 007	1.000	0.045
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.295		0.997		0.943
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.100		0.758		0.003
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9000	0 797	0.044	0 946	0.40)	1 000	0.551
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2000	0.777	0.244	0.710	1.000	1.000	0.876
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.080		0.665		0.482
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.035		0.379		0.839
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10000	0.694		0.884		1.000	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.212		1.008		0.788
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.068		0.592		0.384
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.029		0.318		0.754
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	11000	0.594		0.806		1.000	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.191		1.020		0.694
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.060		0.538		0.308
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	12000		0.026		0.276	0.000	0.667
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	12000	0.504	0.176	0.720	1.024	0.998	0 604
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.1/6		1.034		0.604
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.055		0.498		0.840
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	13000	0 427	0.024	0.636	0.247	0 994	0.504
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	15000	0.427	0 166	0.050	1 049	0.774	0 523
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.051		0.470		0.780
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.022		0.227		0.510
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	14000	0.362		0.557		0.985	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.158		1.064		0.454
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.049		0.448		0.721
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.021		0.212		0.446
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	15000	0.308		0.990		0.969	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.153		0.529		0.397
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.047		0.212		0.666
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 (000	0.062	0.020	0.000	0.099	0.045	0.393
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16000	0.263	0 1 4 9	0.980	0 471	0.945	0.251
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.148		0.4/1		0.551
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.045		0.181		0.017
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	17000	0 226	0.019	0.966	0.085	0.914	0.550
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	17000	0.220	0 145	0.700	0 421	0.711	0 314
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.044		0.157		0.575
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.019		0.071		0.316
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	18000	0.195		0.946		0.876	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.142		0.379		0.957
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.043		0.138		0.539
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.018		0.062		0.288
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	19000	0.169		0.921		0.834	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.140		0.344		0.956
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.042		0.122		0.509
20000 0.147 0.892 0.788 0.138 0.315 0.957 0.042 0.110 0.484 0.018 0.049 0.247		0.1.17	0.018	0.000	0.055	0 500	0.265
0.138 0.315 0.957 0.042 0.110 0.484 0.018 0.049 0.247	20000	0.147	0.120	0.892	0.215	0.788	0.057
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0.138		0.515		0.957
0.016 0.049 0.247			0.042		0.110		0.484
			0.018		0.049		0.247

	A	ſ	Kı	r	Xe	e
21000	0.129		0.858		0.741	
		0.137		0.291		0.958
		0.041		0.100		0.463
		0.018		0.044		0.232
22000	0.113		0.822		0.694	
		0.136		0.270		0.961
		0.041		0.091		0.445
		0.017		0.040		0.219
23000	0.100		0.784		0.647	
		0.135		0.253		0.964
		0.040		0.084		0.431
		0.017		0.037		0.209
24000	0.089		0.745		0.603	
		0.134		0.239		0.967
		0.040		0.079		0.418
		0.017		0.035		0.201
25000	0.079		0.706		0.560	
		0.133		0.227		0.971
		0.040		0.074		0.408
		0.017		0.032		0.194
26000	0.071		0.667		0.520	
		0.132		0.216		0.975
		0.040		0.070		0.399
	0.044	0.017	0.400	0.031	0.400	0.188
27000	0.064	0.100	0.629	0.007	0.482	0.070
		0.132		0.207		0.979
		0.040		0.067		0.391
20000	0.057	0.017	0.502	0.029	0 4 4 7	0.185
28000	0.057	0.121	0.592	0.100	0.447	0.002
		0.151		0.199		0.985
		0.039		0.004		0.384
20000	0.052	0.017	0 557	0.028	0.414	0.178
29000	0.052	0.131	0.557	0 103	0.414	0.088
		0.131		0.195		0.378
		0.039		0.001		0.378
30000	0.047	0.017	0.523	0.027	0.384	0.174
50000	5.047	0 131	0.525	0 187	0.504	0 992
		0.039		0.059		0.373
		0.017		0.026		0.171
		0.017		5.020		0.171

表 6.2.11 BL-9A で推奨する電離箱用ガス

			010-	
E/ke		I0		Ι
V				
4.0	S	N2(30)+He	L	N2
5.0	S	N2(30)+He	L	N2
6.0	S	N2(30)+He	L	N2
7.0	S	N2	L	Ar(15)+N2
8.0	S	N2	L	Ar(15)+N2
9.0	S	N2	L	Ar(15)+N2
10.0	S	N2	L	Ar(15)+N2
11.0	S	N2	L	Ar(15)+N2
12.0	S	Ar(15)+N2	L	Ar(25)+N2
13.0	S	Ar(25)+N2	L	Ar(50)+N2
14.0	S	Ar(25)+N2	L	Ar(50)+N2
15.0	S	Ar(50)+N2	L	Ar



図 6.2.1 I₀用ガスの例





第7節 参考文献

- [1] P. A. Lee, P. H. Citrin, P. Eisenberger and B. M.Kincaid, , *Rev. Mod. Phys.*, 53, 769 (1981).
- [2] G. E. George, W. E. Cleland, Jr., J. H. Enemark, B. E. Smith, C. A. Kipke, S. A. Roberts and S. P. Cramer, *J. Am. Chem. Soc.*, **112**, 2541 (1990).
- [3] http://pfwww.kek.jp/nomura/pfxafs/exp/mos2.html
- [4] "International Tables for X-ray Crystallography", vol.3, p161, Kynoch Press.
- [5] K. Lu and E. A. Stern, *Nucl. Instr. Meth.*, **212**, 475 (1983).
- [6] J. Goulon, C. Goulon-Ginet, R. Cortes and J. M. Dubois, J. Phys. (Paris), 43, 539 (1982).
- [7] M. Nomura, Anal. Chem., 64, 2711 (1992).
- [8] 例えば 日本化学会編「実験化学講座 (続)10 赤外吸収スペクトル」丸善(1964)、同 会編「新実験化学講座 基礎技術3 光 」 丸善(1976)。日本化学会編「第4版 実験 化学講座6分光 」丸善(1991)。古い版の方が試料調製について詳しい。
- [9] E. D. Eanes, J. L. Costa, A. Mackenzie and W. K. Warburton, *Rev. Sci. Instrum.*, 51, 1579 (1980).
 村田隆紀、科研費総合研究(B)研究成果報告書 「X線吸収微細構造の測定・ 解析方法の調査研究」(代表:黒田晴雄)(1991), pp44.
- [10] S. C. Moss, H. Metzger, M. Eisner, H. W. Huang and S. H. Hunter, *Rev. Sci. Instrum.*, 49, 1559 (1978).
- [11] T. S. Ertel and H. Bertagnolli, Nucl. Instrum. Methods, B73, 199 (1993).
- [12] F. Villain, V. Briois, I. Castro, C. Helary and M. Verdaguer, Anal. Chem., 65, 2545 (1993).
- [13] J. C. Mikkelsen, Jr., J. B. Boyce and R. Allen, *Rev. Sci. Instrum.*, 51, 388 (1980). K. Tamura, M. Inui, M. Yao, H. Endo, S. Hosokawa, H. Hoshino, Y. Katayama and K. Maruyama, *J. Phys., Condens. Matter*, 3, 7495 (1991).
- [14] S. Sueno, I. Nakai, M. Imafuku, H .Morikawa, M. Kimata, K. Ohsumi, M. Nomura and O. Shimomura, *Chem. Lett.*, 1663 (1986).
- [15] P. Rabe, G. Tolkiehn and A. Werner, J. Phys., C12, 1173 (1979).
- [16] W. Niemann, doctor thesis, Kiel (1985).
- [17] 野村、放射光、2 (8), 63 (1989). M. Nomura and A. Koyama, KEK Report 89-16 (1989).
- [18] E. A. Stern and K. Lu, Nucl. Instrum. Methods, 195, 415 (1982).
- [19] F. Comin, L.Incoccia and S. Mobilio, J. Phys., E16, 83 (1983).
- [20] E. A. Stern and K. Kim, *Phys. Rev.*, **B23**, 3781 (1981).
- [21] D. M. Pease, Appl. Spectrosc., 30, 405 (1976).
- [22] E.R.Cohen and B.N.Taylor, J. Chem. Phys. Ref. Data, 17, 1795 (1988).
- [23] M. Nomura KEK Report 85-7 (1985).